

輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令（第八条第九号、第十四条の二及び第二十八条については、平成二十年経済産業省令第五十五号までの改正に対応）

**Ordinance of the Ministry Specifying Goods and Technologies Pursuant to Provisions of the Appended Table 1 of the Export Control Order and the Appended Table of the Foreign Exchange Order (Amendments up to Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry No. 55 of 2008 are reflected in Article 8, item (ix), Article 14-2, and Article 28)**

（平成三年十月十四日通商産業省令第四十九号）

(Ordinance of the Ministry of International Trade and Industry No. 49 of October 14, 1991)

輸出貿易管理令（昭和二十四年政令第三百七十八号）別表第一及び外国為替管理令（昭和五十五年政令第二百六十号）別表の規定に基づき、輸出貿易管理令別表第一及び外国為替管理令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令を次のように制定する。

This Ordinance of the Ministry specifying goods and technologies pursuant to provisions of the Appended Table 1 of the Export Control Order and the Appended Table of the Foreign Exchange Control Order is enacted as set forth hereinafter, pursuant to provisions of the Export Control Order (Cabinet Order No. 378 of 1949) and the Appended Table of the Foreign Exchange Control Order (Cabinet Order No. 260 of 1980).

（輸出貿易管理令別表第一関係）

(Re: Appended Table 1 of the Export Control Order)

第一条 輸出貿易管理令（以下「輸出令」という。）別表第一の二の項の経済産業省令で定める仕様のもは、次のいずれかに該当するものとする。

Article 1 Goods with specifications prescribed by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 2 of the appended table 1 of the Export Control Order (referred to hereinafter as the "Export Order") shall fall under any of the following.

一 核燃料物質又は核原料物質であつて、次のいずれかに該当するもの

(i) Nuclear fuel materials or nuclear source materials falling under any of the following

- イ ウラン又はその化合物
  - (a) Uranium or uranium compounds
- ロ トリウム又はその化合物
  - (b) Thorium or thorium compounds
- ハ プルトニウム又はその化合物
  - (c) Plutonium or plutonium compounds
- ニ イからハまでの貨物の一又は二以上を含むもの
  - (d) Nuclear fuel materials or nuclear source materials including 1 or 2 or more of the goods in (a) through (c)
- 三 原子炉若しくはその部分品若しくは附属装置又は車両、船舶、航空機若しくは宇宙空間用若しくは打ち上げ用の飛しょう体の原子炉用に設計した発電若しくは推進のための装置
  - (ii) Nuclear reactors, components or auxiliaries thereof, or power-generating or propulsion equipment specially designed for use in vehicles, vessels, aircraft or space use, or for nuclear reactors for launching space crafts
- 四 重水素又は重水素化合物であって、重水素の原子数の水素の原子数に対する比率が五、〇〇〇分の一を超えるもの
  - (iii) Deuterium or deuterium compounds with a hydrogen to deuterium atom number ratio exceeding 1/5,000
- 五 人造黒鉛であって、ほう素当量が全重量の一、〇〇〇、〇〇〇分の五未満で、かつ、二〇度の温度における見掛け比重が一・五〇を超えるもののうち、次のいずれかに該当するもの
  - (iv) Among artificial graphite with a boron content level less than 5/1,000,000 of the total weight and apparent specific gravity exceeding 1.50 at 20 degrees centigrade, those falling under any of the following
    - イ 原子炉用のもの
      - (a) Artificial graphite for use in nuclear reactors
    - ロ 原子炉用に用いることができるもの（イに該当するものを除く。）
    - (b) Artificial graphite usable in nuclear reactors (excluding those falling under (a))
- 六 放射線を照射した核燃料物質若しくは核原料物質の分離用若しくは再生用に設計した装置又はその部分品若しくは制御装置
  - (v) Equipment specially designed for the separation or reprocessing of irradiated nuclear fuel materials or nuclear source materials, or components or controllers thereof
- 七 リチウムの同位元素の分離用の装置又は核燃料物質の成型加工用の装置
  - (vi) Equipment for the separation of lithium isotopes, or equipment for the fabrication of nuclear fuel materials
- 八 ウランの同位元素の分離用の装置であって、次のいずれかに該当するもの若しくはその附属装置又はこれらの部分品
  - (vii) Equipment for the separation of uranium isotopes falling under any of the

following, or auxiliaries thereof or components thereof

イ ガス拡散法を用いるもの

(a) Equipment utilizing gas diffusion methods

ロ 遠心分離法を用いるもの

(b) Equipment utilizing centrifuge separation methods

ハ ノズル分離法を用いるもの

(c) Equipment utilizing nozzle separation methods

ニ ボルテックス法を用いるもの

(d) Equipment utilizing vortex methods

ホ 化学交換法を用いるもの

(e) Equipment utilizing chemical exchange methods

ヘ レーザー分離法を用いるもの

(f) Equipment utilizing laser separation methods

ト プラズマ法を用いるもの

(g) Equipment utilizing plasma methods

チ 電磁分離法を用いるもの

(h) Equipment utilizing magnetic separation methods

八 周波数変換器又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの

(viii) Frequency changers or components thereof falling under any of the following

イ ガス遠心分離機用の周波数変換器であって、次の（一）から（四）までのすべてに該当するもの又はその部分品

(a) Frequency changers for gas centrifuges that fall under all of the following 1. through 4. or components thereof

（一） 出力が三相以上のものであって、周波数が六〇〇ヘルツ以上二、〇〇〇ヘルツ以下の出力を得ることができるもの

1. Frequency changers with output of 3 or more phases and a frequency of 600 hertz or more and 2,000 hertz or less

（二） 出力電圧のひずみ率が二パーセント未満のもの

2. Frequency changers with output distortion ratio less than 2%

（三） 出力周波数の精度がプラスマイナス〇・一パーセント未満のもの

3. Frequency changers with output frequency accuracy less than plus/minus 0.1%

（四） 出力基本波電力の入力基本波電力に対する比率が八〇パーセントを超えるもの

4. Frequency changers with ratio of input base wave power to output base wave power exceeding 80%

ロ 周波数変換器であって、次の（一）から（四）までのすべてに該当するもの（イに該当するものを除く。）

(b) Frequency changers falling under all of the following 1. through 4. (excluding those falling under (a))

- (一) 四〇ワット以上の出力を得ることができるもの
- 1. Frequency changers capable of yielding output of 40 watts or more
- (二) 出力が三相以上のものであって、周波数が六〇〇ヘルツ超二、〇〇〇ヘルツ未満の出力を得ることができるもの
- 2. Frequency changers with output of 3 or more phases and a frequency exceeding 600 hertz and less than 2,000 hertz
- (三) 出力電圧のひずみ率が一〇パーセント未満のもの
- 3. Frequency changers with output distortion ratio less than 10%
- (四) 出力周波数の精度がプラスマイナス〇・一パーセント未満のもの
- 4. Frequency changers with output frequency accuracy less than plus/minus 0.1%
- 九 ニッケルの粉であって、径の平均値が一〇マイクロメートル未満で、かつ、重量比による純度が九九パーセント以上のもの又はこれを用いて製造した多孔質金属
- (ix) Nickel powders with an average diameter less than 10 micrometers and a weight-based purity level of 99% or more, or porous metals produced thereof
- 十 重水素若しくは重水素化合物の製造に用いられる装置又はその部分品若しくは附属装置であって、次のいずれかに該当するもの
- (x) Equipment used for the production of deuterium or deuterium compounds, or components or auxiliaries thereof that fall under any of the following
- イ 重水素若しくは重水素化合物の製造用の装置（濃縮用の装置を含む。）又はその部分品若しくは附属装置
- (a) Equipment for the production of deuterium or deuterium compounds, (including concentration equipment), or components or auxiliaries thereof
- ロ 重水の製造に用いられる装置又はその部分品若しくは附属装置であって、次のいずれかに該当するもの（イに該当するものを除く。）
- (b) Equipment used for the production of heavy water or components or auxiliaries thereof falling under any of the following (excluding those falling under (a))
- (一) 棚段塔であって、次の1から3までのすべてに該当するもの
- 1. Shelf plate towers falling under all of the following i. through iii.
  - 1 細粒炭素鋼を用いたもの
  - i. Towers utilizing fine-grain carbon steel
  - 2 ニメガパスカル以上の圧力で用いることができるもの
  - ii. Towers usable at pressure of 2 megapascals or more
  - 3 (二)に掲げる内部構造物を有するもの
  - iii. Towers having internal structural elements listed in 2.
- (二) 棚段塔の内部構造物であって、次の1から3までのすべてに該当するもの
- 2. Internal structural elements of shelf plate towers and that fall under all of the following i. through iii.
  - 1 断面積が二・五四平方メートル以上のものであって、二つ以上の部分に分

割されているもの

- i. Internal structural elements with a cross section area of 2.54 square meters or more and divided into 2 or more parts
    - 2 気体と液体を向流的に流して接触させるように設計したもの
  - ii. Internal structural elements designed to propel gases and fluids in contact counter to the current
    - 3 硫化水素に対して耐食性のある材料を用いたもの
  - iii. Internal structural elements utilizing materials corrosion-resistant against hydrogen sulfide
- (三) 低温で用いられる蒸留塔であって、次の1から4までのすべてに該当するもの
3. Distillation columns used at low temperatures that fall under all of the following i. through iv.
- 1 細粒ステンレス綱であって、水素ぜい性のないものを用いたもの
  - i. Fine-grain stainless steel using steels without hydrogen embrittlement
    - 2 断面積が $0.785$ 平方メートル以上であり、かつ、長さが五メートル以上のもの
  - ii. Distillation columns with a cross section area of  $0.785$  square meters or more and a length of 5 meters or more
    - 3 温度が零下二三八度以下で用いることができるように設計したもの
  - iii. Distillation columns designed to be usable at  $-238$  degrees centigrade or less
    - 4  $0.5$ メガパスカル以上五メガパスカル以下の圧力範囲において用いることができるように設計したもの
  - iv. Distillation columns designed to be usable within a pressure range from  $0.5$  megapascals or more to 5 megapascals or less
- (四) 真空蒸留用の塔に用いることができるように設計した充てん物であって、化学的にぬれ性を改善する処理を行った燐青銅製のもののうち、メッシュ状のもの
4. Among filling materials designed to be usable in a vacuum distillation column, and phosphorus bronze subjected to a process that chemically improves wettability, those that are mesh-shaped
- (五) 温度が零下二三八度以下で用いることができるように設計したターボエキスパンダであって、水素の排出量が一時間につき一、〇〇〇キログラム以上のもの
5. Turboexpanders designed to be usable at  $-238$  degrees centigrade or less with a hydrogen emission level of 1,000 kilograms per hour or more
- (六) アンモニア合成装置であって、イに該当する装置に用いることができるもの
6. Ammonia synthesizers usable in equipment falling under (a)
- (七) カリウムアミドを含む液化アンモニアを循環させることができるポンプ

であって、次の1から3までのすべてに該当するもの

7. Pumps capable of circulating liquid ammonia containing potassium amide, that fall under all of the following i. through iii.

1 気密な構造のもの

i. Pumps with a sealed structure

2 一・五メガパスカル以上六〇メガパスカル以下の圧力範囲において用いることができるもの

ii. Pumps usable within a pressure range from 1.5 megapascals or more to 60 megapascals or less

3 吐出し量が一時間につき八・五立方メートルを超えるもの

iii. Pumps with discharge exceeding 8.5 cubic meters per hour

十の二 三酸化ウラン、六ふっ化ウラン、二酸化ウラン、四ふっ化ウラン、金属ウラン若しくは四塩化ウランの製造用の装置であって、次のいずれかに該当するもの若しくはその附属装置又はこれらの部分品

(x)-2 Equipment for the production of uranium trioxide, uranium hexafluoride, uranium dioxide, uranium tetrafluoride, metallic uranium or uranium tetrachloride, falling under any of the following, or auxiliaries or components thereof

イ ウラン鉱石を原料とする三酸化ウランの製造用の装置

(a) Equipment used for the production of uranium trioxide using uranium ore as raw materials

ロ 三酸化ウラン又は四ふっ化ウランを原料とする六ふっ化ウランの製造用の装置

(b) Equipment used for the production of uranium hexafluoride using uranium trioxide or uranium tetrafluoride as raw materials

ハ 三酸化ウラン又は六ふっ化ウランを原料とする二酸化ウランの製造用の装置

(c) Equipment used for the production of uranium dioxide using uranium trioxide or uranium hexafluoride as raw materials

ニ 二酸化ウラン又は六ふっ化ウランを原料とする四ふっ化ウランの製造用の装置

(d) Equipment used for the production of uranium tetrafluoride using uranium dioxide or uranium hexafluoride as raw materials

ホ 四ふっ化ウランを原料とする金属ウランの製造用の装置

(e) Equipment used for the production of metallic uranium using uranium tetrafluoride as raw materials

ヘ 二酸化ウランを原料とする四塩化ウランの製造用の装置

(f) Equipment used for the production of uranium tetrachloride using uranium dioxide as raw materials

十の三 二酸化プルトニウム、しゅう酸プルトニウム、過酸化プルトニウム、三ふっ化プルトニウム、四ふっ化プルトニウム若しくは金属プルトニウムの製造用の装置若しくはその附属装置又はこれらの部分品

(x)-3 Equipment used for the production of plutonium dioxide, plutonium oxalate, plutonium peroxide, plutonium trifluoride, plutonium tetrafluoride

or metallic plutonium, or auxiliaries or components thereof

十一 しごきスピニング加工機又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの

(xi) Flow-forming machines or components thereof that fall under any of the following

イ しごきスピニング加工機であって、数値制御装置又は電子計算機によって制御することができるもののうち、ローラの数が三以上のもの

(a) Among flow-forming machines capable of being controlled by numerically-controlled coordinate measurement equipment or computer, those with 3 or more rollers

ロ 内径が七五ミリメートル超四〇〇ミリメートル未満の円筒形のロータを成形することができるように設計したマンドレル

(b) Mandrels designed to be capable of forming cylindrical rotors with an internal diameter exceeding 75 millimeters and less than 400 millimeters

十二 削除

(xii) Deleted

十三 削除

(xiii) Deleted

十四 工作機械（金属、セラミック又は複合材料を加工することができるものに限る。）であって、輪郭制御をすることができる軸数が二以上の電子制御装置を取り付けることができるもののうち、次のイからニまでのいずれかに該当するもの（ホに該当するものを除く。）

(xiv) Among machine tools (limited to those capable of processing metals, ceramics and composite materials) to which an electronic controller with 2 or more axes capable of performing contour control can be attached, those falling under any of the following (a) through (d)

イ 旋削をすることができる工作機械であって、次の（一）及び（二）に該当するもの（（三）に該当するものを除く。）

(a) Machine tools capable of lathe turning that fall under the following 1. and 2. (excluding those falling under 3.)

（一） 国際標準化機構が定めた規格（以下「国際規格」という。）ISO 230-2:1988 〇／二（一九八八）で定める測定方法により直線軸の全長について測定したときの位置決め精度が〇・〇〇六ミリメートル未満のもの

1. Machine tools in which the precision of positioning of the rectilinear axes is 0.006 millimeters or less when measured by the measurement method specified by the International Standards Organization (ISO) (hereinafter referred to as "International Standard") ISO 230-2:1988

（二） 直径が三五ミリメートルを超えるものを加工することができるもの

2. Machine tools capable of processing items with a diameter exceeding 35 millimeters

（三） 棒材作業用の旋盤のうち、スピンドル貫通穴から材料を差し込み加工す

るものであって、次の1及び2に該当するもの

3. Bar work lathes materials are inserted from a spindle hole of which for process, and that fall under the following i. and ii.

1 加工できる材料の最大直径が四二ミリメートル以下のもの

i. Bar work lathes with the maximum diameter of material to be processed of 42 millimeters or less

2 チャックを取り付けることができないもの

ii. Bar work lathes incapable of having a chuck attached

ロ フライス削り又は中ぐりを行うことができる工作機械であって、次の(一)から(三)までのいずれかに該当するもの(四)に該当するものを除く。)

(b) Machine tools capable of milling or boring that fall under any of the following 1. through 3. (excluding those falling under 4.)

(一) 国際規格ISO 230/2 (1988)で定める測定方法により直線軸の全長について測定したときの位置決め精度が0.006ミリメートル未満のもの

1. Machine tools in which the precision of positioning of the rectilinear axes is 0.006 millimeters or less when measured by the measurement method specified by International Standard ISO 230-2:1988

(二) 輪郭制御を行うことができる回転軸の数が二以上のもの

2. Machine tools with 2 or more rotational axes capable of controlling contour

(三) 輪郭制御を行うことができる軸数が五以上のもの

3. Machine tools with 5 or more axes capable of controlling contour

(四) フライス盤であって、次の1及び2に該当するもの

4. Milling machines falling under the following i. and ii.

1 国際規格ISO 841 (数値制御工作機械—座標軸及び運動の記号)で定めるX軸の方向の移動量が二メートルを超えるもの

i. Milling machines exhibiting a range of motion in the X-axis direction exceeding 2 meters specified by ISO 841 (numerically-controlled machine tools - axis and motion nomenclature)

2 国際規格ISO 230/2 (1988)で定める測定方法により国際規格ISO 841で定めるX軸の全長について測定したときの位置決め精度が0.03ミリメートルを超えるもの

ii. Milling machines in which the precision of positioning of the X-axis specified by ISO 841 exceeds 0.03 millimeters when measured by the measurement method specified by International Standard ISO 230-2:1988

ハ 研削を行うことができる工作機械であって、次の(一)から(三)までのいずれかに該当するもの(次の(四)又は(五)に該当するものを除く。)

(c) Machine tools capable of grinding that fall under any of the following 1. through 3. (excluding those falling under 4. or 5.)



- (一) 国際規格 I S O 二三〇/二 (一九八八) で定める測定方法により直線軸の全長について測定したときの位置決め精度が〇・〇〇四ミリメートル未満のもの
1. Machine tools in which the precision of positioning of the rectilinear axes is 0.004 millimeters or less when measured by the measurement method specified by International Standard ISO 230-2:1988
- (二) 輪郭制御をすることができる回転軸の数が二以上のもの
2. Machine tools with 2 or more rotational axes capable of controlling contour
- (三) 輪郭制御をすることができる軸数が五以上のもの
3. Machine tools with 5 or more axes capable of controlling contour
- (四) 円筒外面研削盤、円筒内面研削盤又は円筒内外面研削盤であって、次の1及び2に該当するもの
4. A cylindrical exterior grinding machine, a cylindrical interior grinding machine, or a cylindrical interior-exterior grinding machine that falls under the following i. and ii.
- 1 外径又は長さが一五〇ミリメートル以内のものを研削するように設計したもの
- i. A machine designed to grind objects with an external diameter or length of 150 millimeters or less
- 2 国際規格 I S O 八四一で定める X 軸、Z 軸及び C 軸のみを有するもの
- ii. A machine possessing only X-axis, Z-axis and C-axis as specified by ISO 841
- (五) ジグ研削盤であって、次の1及び2のいずれにも該当しないもの
5. Jig grinding machines that do not fall under the following i. nor ii.
- 1 国際規格 I S O 八四一で定める Z 軸を有するもののうち、国際規格 I S O 二三〇/二 (一九八八) で定める測定方法により当該 Z 軸の全長について測定したときの位置決め精度が〇・〇〇四ミリメートル未満のもの
- i. Among jig grinding machines possessing Z-axis specified by ISO 841, those the precision of positioning of the Z-axis of which is less than 0.004 millimeters when measured by the measurement method specified by International Standard ISO 230-2:1988
- 2 国際規格 I S O 八四一で定める W 軸を有するもののうち、国際規格 I S O 二三〇/二 (一九八八) で定める測定方法により当該 W 軸の全長について測定したときの位置決め精度が〇・〇〇四ミリメートル未満のもの
- ii. Among jig grinding machines possessing W-axis specified by ISO 841, those the precision of positioning of the W-axis of which is less than 0.004 millimeters when measured by the measurement method specified by International Standard ISO 230-2:1988
- ニ 放電加工 (ワイヤ放電加工を除く。) をすることができる工作機械であって、輪郭制御をすることができる回転軸の数が二以上のもの

(d) Machine tools capable of performing electrical discharge machining (excluding wire electrical discharge machining), with 2 or more rotational axes capable of contour control

ホ 工作機械であって、次のいずれかを製造するためのみに設計したもの

(e) Machine tools designed only for the production of any of the following

(一) 歯車

1. Gears

(二) クランク軸又はカム軸

2. Crank shafts or cam shafts

(三) 工具又は刃物

3. Tools or blades

(四) 押出機のウオーム

4. Extruder worms

十五 削除

(xv) Deleted

十六 削除

(xvi) Deleted

十七 測定装置（工作機械であって、測定装置として使用することができるものを含む。）であって、次のいずれかに該当するもの

(xvii) Measurement equipment (including machine tools with a measurement function) that falls under any of the following

イ 電子計算機又は数値制御装置により制御される測定装置であって、次の（一）及び（二）に該当するもの

(a) Measurement equipment controlled by computers or numerically-controlled coordinate measurement equipment, that falls under the following 1. and 2.

(一) 測定軸の数が二以上のもの

1. Measurement equipment with 2 or more measurement axes

(二) 精度が $0.2$ マイクロメートル未満のプロブを用いてドイツ技術者協会の規格（VDI/VDE 2617）で定める測定方法により測定した場合に、測定軸のマイクロメートルで表した測定の不確かさの数値がミリメートルで表した当該測定軸の長さに $0.001$ を乗じて得た数値に $1.25$ を加えた数値以下となる測定軸を有するもの

2. Measurement equipment possessing measurement axes for which the numerical value of the measurement uncertainty for the measurement axis, expressed in micrometers, is less than the numerical value of the length of said measurement axis, expressed in millimeters, multiplied by  $0.001$  and a value of  $1.25$  added, when measured using a method specified by a standard of the German Association of Engineers (VDI/VDE 2617) using a probe with a precision less than  $0.2$  micrometers.

- ロ 直線上の変位を測定するものであって、次のいずれかに該当するもの
- (b) Measurement equipment measuring displacement along a straight line that falls under any of the following
- (一) 非接触型の測定システムであって、〇・二ミリメートルまでの測定レンジにおいて、分解能が〇・二マイクロメートル以下のもの
1. Non-contact type measurement systems with a resolution of 0.2 micrometers or less within a measurement range up to 0.2 millimeters
- (二) 線形電圧差動変圧器を用いた測定システムであって、次の1及び2に該当するもの
2. Measurement systems using linear voltage differential transformers that fall under the following i. and ii.
- 1 五ミリメートルまでの測定レンジにおいて、直線性が〇・一パーセント以下のもの
- i. Systems with a linearity of 0.1% or less within a measurement range up to 5 millimeters
- 2 一九度以上二一度以下の温度範囲において測定した場合に、ドリフトが二四時間当たり〇・一パーセント以下のもの
- ii. Systems exhibiting a drift of 0.1% per 24 hours or less when measured within a temperature range of 19 degrees centigrade or more and 21 degrees centigrade or less
- (三) 次の1及び2に該当するもの
3. Measurement equipment falling under the following i. and ii.
- 1 レーザー光を用いて測定することができるもの
- i. Measurement equipment capable of measuring using a laser beam
- 2 一九度以上二一度以下の温度範囲及び八〇、〇〇〇パスカル以上一二〇、〇〇〇パスカル以下の気圧範囲において、次の一及び二の特性を一二時間維持することができるもの
- ii. Measurement equipment capable of maintaining the properties in the following a. and b. for 12 hours within a temperature range of 19 degrees centigrade or more and 21 degrees centigrade or less and a pressure range of 80,000 pascals or more and 120,000 pascals or less
- 一 測定できる最大の測定レンジにおいて、分解能が〇・一マイクロメートル以下のもの
- a. Measurement equipment with a resolution of 0.1 micrometers or less within the largest measurement range over which measurement is capable of being performed
- 二 ドイツ技術者協会の規格（V D I / V D E 二六一七）で定める測定方法により測定した場合に、測定軸のマイクロメートルで表した測定の不確かさの数値がミリメートルで表した当該測定軸の長さに〇・〇〇〇五を乗じて得た数値に〇・二を加えた数値以下のもの
- b. Measurement equipment possessing a numerical value less than 0.2

added to the value obtained by multiplying the measurement uncertainty for the measurement axis, expressed in micrometers, by the length of that measurement axis, expressed in millimeters, by 0.0005, when measured using a method specified by a standard of the German Association of Engineers (VDI/VDE 2617).

ハ 角度の変位を測定するものであって、ドイツ技術者協会の規格（VDI/VDE 二六一七）で定める測定方法により測定した場合に、角度位置の偏差の最大値が $0.00025$ 度以下のもの（平行光線を用いて鏡の角度の変位を測定する光学的器械を除く。）

(c) Measurement equipment that measures angular displacement, and with a maximum angular location deviation of 0.00025 degrees or less, when measured using the method specified by a standard of the German Association of Engineers (VDI/VDE 2617) (excluding optical instruments that measure angular displacement using parallel light beams)

ニ 曲面形状を有するものの長さ及び角度を同時に測定することができる測定装置であって、次の（一）及び（二）に該当するもの

(d) Measurement equipment capable of simultaneously measuring the length and angle of objects having curved shapes and that fall under the following 1. and 2.

（一） ドイツ技術者協会の規格（VDI/VDE 二六一七）で定める測定方法により測定した場合に、測定軸の測定の不確かさの数値が測定距離五ミリメートル当たり三・五マイクロメートル以下のもの

1. Measurement equipment with a numerical value for the measurement uncertainty for measurement axes of 3.5 micrometers or less per 5 millimeters of measurement distance, when measured using methods specified by a standard of the German Association of Engineers (VDI/VDE 2617)

（二） ドイツ技術者協会の規格（VDI/VDE 二六一七）で定める測定方法により測定した場合に、角度位置の偏差の最大値が $0.02$ 度以下のもの

2. Measurement equipment with a maximum angular position deviation of 0.02 degrees or less, when measured using methods specified by a standard of the German Association of Engineers (VDI/VDE 2617)

十八 誘導炉、アーク炉若しくはプラズマ若しくは電子ビームを用いた溶解炉又はこれらの附属装置であって、次のいずれかに該当するもの

(xviii) Induction furnaces, arc furnaces or plasma melting furnaces or electron-beam melting furnaces or auxiliaries thereof that fall under any of the following

イ 真空誘導炉若しくは不活性ガスを用いる誘導炉（半導体ウエハの加工用のものを除く。）であって、次の（一）から（三）までのすべてに該当するもの又はこれらの電源装置であって、出力が五キロワット以上のもの

(a) Vacuum induction furnaces or induction furnaces utilizing non-volatile

gases (excluding those used for process of semiconductor wafers) and that fall under all of the following 1. through 3., or power units thereof with output of 5 kilowatts or more

(一) 炉の内部を八五〇度を超える温度にすることができるもの

1. Furnaces capable of heating the interior thereof exceeding 850 degrees centigrade

(二) 直径が六〇〇ミリメートル以下の誘導コイルを有するもの

2. Furnaces having an induction coil with a diameter of 600 millimeters or less

(三) 電源装置からの入力が入力五キロワット以上のもの

3. Furnaces with input from the power units of 5 kilowatts or more

ロ アーク炉であって、真空中若しくは不活性ガス中で金属を溶解して鑄造するもののうち、容量が一、〇〇〇立方センチメートル超二〇、〇〇〇立方センチメートル未満の消耗電極を有し、かつ、一、七〇〇度を超える温度で金属を溶解することができるもの又は電子計算機を用いた当該アーク炉用の制御装置若しくは監視装置

(b) Among arc furnaces that melt and cast metals in a vacuum or under non-volatile gases, those possessing consumable electrodes with a capacity exceeding 1,000 cubic centimeters and less than 20,000 cubic centimeters, and capable of melting metals at in excess of 1,700 degrees centigrade or controllers or monitor equipment for the arc furnaces and that utilize computers

ハ 出力が五〇キロワット以上のプラズマ若しくは電子ビームを用いた溶解炉であって、真空中若しくは不活性ガス中で金属を溶解して鑄造するもののうち、一、二〇〇度を超える温度で金属を溶解することができるもの又は電子計算機を用いた当該溶解炉用の制御装置若しくは監視装置

(c) Among plasma melting furnaces or electron-beam melting furnaces with an output of 50 kilowatts or more that melt and cast metal in a vacuum or within non-volatile gases, those capable of melting metals at in excess of 1,200 degrees centigrade, and controllers or monitor equipment for the melting furnaces that utilize computers

十九 アイソスタチックプレスであって、次のイ及びロに該当するもの又はその制御装置若しくは当該アイソスタチックプレスに用いることができるように設計した型

(xix) Isostatic presses falling under the following (a) and (b) or controllers thereof or molds designed to be capable of use with isostatic presses

イ 最大圧力が六九メガパスカル以上のもの

(a) Isostatic presses with a maximum pressure of 69 megapascals or more

ロ 中空室の内径が一五二ミリメートルを超えるもの

(b) Isostatic presses with hollow cavities possessing an internal diameter which exceeds 152 millimeters

二十 ロボット（操縦ロボット及びシーケンズロボットを除く。）若しくはエンドエ

- フェクターであって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの制御装置
- (xx) Robots (excluding operating robots and sequence robots) or end effectors that fall under any of the following, or controllers thereof
- イ 工業標準化法（昭和二十四年法律第百八十五号）に基づく日本工業規格（以下単に「日本工業規格」という。）C〇九三〇号（電気機器の防爆構造総則）で定める防爆構造のもの（塗装用のものを除く。）
- (a) Explosion-proof robots or end effectors as specified by Japan Industrial Standard C0930 (general provisions of explosion-proof structure of electrical apparatus) based on the Industrial Standardization Act (Act No. 185 of 1949) (hereinafter referred to as "Japan Industrial Standard") (excluding those used for painting)
- ロ 全吸収線量がシリコン換算で五〇、〇〇〇グレイを超える放射線照射に耐えることができるように設計したもの
- (b) Robots or end effectors designed to be able to withstand irradiation with total absorption line volume exceeding 50,000 grays on a silicon conversion basis
- 二十一 振動試験装置又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
- (xxi) Vibration test equipment or components thereof that fall under any of the following
- イ デジタル制御方式であり、かつ、電動式の振動試験装置であって、次の（一）及び（二）に該当するもの
- (a) Vibration test equipment digitally controlled and electrically powered that fall under the following 1. and 2.
- （一） 試験体がない状態における加振力が五〇キロニュートン以上のものであって、二〇ヘルツ超二、〇〇〇ヘルツ未満の周波数範囲で加速度の実効値が九八メートル毎秒毎秒以上の振動を発生させることができるもの
1. Equipment with an excitation force of 50 kilonewtons or more in a state with no test object present, and capable of generating vibrations with an acceleration effective value of 98 meters per second squared or more, in a frequency range from exceeding 20 hertz and less than 2,000 hertz.
- （二） フィードバック制御技術又は閉ループ制御技術を用いたもの
2. Equipment utilizing feedback control technology or closed-loop control technology
- ロ 振動試験装置の部分品であって、次のいずれかに該当するもの
- (b) Components of vibration test equipment and that fall under any of the following
- （一） イに該当する振動試験装置の制御に使用するように設計した部分品であって、振動試験用のプログラムを用いたものであり、かつ、五キロヘルツを超える帯域幅で実時間での振動試験をデジタル制御するもの
1. Components designed for use in control of vibration test equipment falling under (a), using programs for a vibration test, and performing

digital control of vibration tests in real time in bandwidth exceeding 5 kilohertz

(二) イに該当する振動試験装置に使用することができる振動発生機であって、試験体がない状態における加振力が五〇キロニュートン以上のもの

2. Vibration generators usable for vibration test equipment falling under (a), with an excitation force of 50 kilonewtons or more in a state with no test object present

(三) イに該当する振動試験装置に使用することができる振動台又は振動発生装置の部分品であって、試験体がない状態における加振力が五〇キロニュートン以上となる振動を発生させるために二台以上の振動発生機を接続して使用するよう設計したもの

3. Parts of vibration tables or vibration generators capable of use for vibration test equipment falling under (a) and designed for use by connecting 2 or more vibration generators in order to generate vibrations with exciting force of 50 kilonewtons or more in a state with no test object present

二十二 ガス遠心分離機のロータに用いられる構造材料であって、次のいずれかに該当するもの

(xxii) Structural materials capable of use for gas centrifuge rotors that fall under any of the following

イ アルミニウム合金（鍛造したものを含む。）であって、引張強さが二〇度の温度において四六〇メガパスカル以上となるもののうち、外径が七五ミリメートルを超える棒又は円筒形のもの

(a) Among aluminum alloys (including forged alloy) with a tensile strength of 460 megapascals or more at 20 degrees centigrade, those with a shaft-like or cylindrical shape and an external diameter exceeding 75 millimeters

ロ 炭素繊維、アラミド繊維若しくはガラス繊維、炭素繊維若しくはガラス繊維を使用したプリプレグ又は炭素繊維若しくはアラミド繊維を使用した成型品であって、次のいずれかに該当するもの

(b) Carbon fibers, aramid fibers or glass fibers, or prepreg made from carbon fibers or glass fibers, or molded products made with carbon fibers or aramid fibers, falling under any of the following

(一) 炭素繊維又はアラミド繊維であって、次のいずれかに該当するもの

1. Carbon fibers or aramid fibers that fall under any of the following

1 比弾性率が一二、七〇〇、〇〇〇メートル以上のもの

i. Fibers with a specific elastic modulus of 12,700,000 meters or more

2 比強度が二三五、〇〇〇メートル以上のもの

ii. Fibers with a specific strength of 235,000 meters or more

(二) ガラス繊維であって、次の1及び2に該当するもの

2. Glass fibers falling under the following i. and ii.

1 比弾性率が三、一八〇、〇〇〇メートル以上のもの

- i. Glass fibers with a specific elastic modulus of 3,180,000 meters or more
  - 2 比強度が七六、二〇〇メートル以上のもの
- ii. Glass fibers with a specific strength of 76,200 meters or more
- (三) (一)又は(二)に該当する炭素繊維又はガラス繊維に熱硬化性樹脂を  
含浸したプリプレグであって、次のいずれかに該当するもの
- 3. Prepreg consisting of carbon fibers or glass fibers falling under 1. or 2.  
and impregnated with thermosetting resin that fall under any of the  
following
  - 1 繊維状のもの
    - i. Fibrous prepreg
      - 2 幅が一五ミリメートル以下のテープ状のもの
    - ii. Tape-shaped prepreg with a width of 15 millimeters or less
  - (四) (一)に該当する繊維又は(三)に該当するプリプレグ(炭素繊維を使用  
したものに限る。)を用いた円筒形の成型品であって、内径が七五ミリメ  
ートル超四〇〇ミリメートル未満のもの
- 4. Cylindrical formed goods utilizing fibers falling under 1. or prepreg  
falling under 3. (limited to goods utilizing carbon fiber) with an  
internal diameter exceeding 75 millimeters and less than 400  
millimeters
- ハ マルエージング鋼であって、引張強さが二〇度の温度において二、〇五〇メガ  
パスカル以上となるもののうち、寸法の最大値が七五ミリメートルを超えるもの
- (c) Among maraging steels with a tensile strength of 2,050 megapascals or  
more at 20 degrees centigrade, those with the greatest value of dimensions  
exceeding 75 millimeters
- ニ チタン合金(鍛造したものを含む。)であって、引張強さが二〇度の温度にお  
いて九〇〇メガパスカル以上となるもののうち、外径が七五ミリメートルを超え  
る棒又は円筒形のもの
- (d) Among titanium alloys (including forged alloys) with a tensile strength of  
900 megapascals or more at 20 degrees centigrade, those with a shaft-like  
or cylindrical shape and an external diameter exceeding 75 millimeters
- 二十三 ベリリウム若しくはベリリウム合金(ベリリウムの含有量が全重量の五〇パ  
ーセントを超えるものに限る。)の地金若しくはくず若しくはベリリウム化合物又  
はこれらの半製品若しくは一次製品
- (xxiii) Metals, waste, or scrap of beryllium and beryllium alloys (limited to  
those with a beryllium content exceeding 50% of the total weight) or  
beryllium compounds, or primary or semi-finished products thereof
- 二十四 核兵器の起爆用のアルファ線源に用いられる物質又はその原料となる物質で  
あって、次のいずれかに該当するもの
- (xxiv) Substances used as alpha sources for the detonation of nuclear weapons,  
or raw materials thereof that fall under any of the following
  - イ 重量比による純度が九九・九九パーセント以上のビスマスであって、銀の含有



量が全重量の〇・〇〇一パーセント未満のもの

(a) Bismuth with a weight-based purity level of 99.99% or more and a silver content less than 0.001% of the total weight

ロ ラジウム二二六、ラジウム二二六合金、ラジウム二二六化合物若しくはラジウム二二六混合物又はこれらの半製品若しくは一次製品（医療用装置に組み込まれたもの及び装置に内蔵されたものであって一装置当たりの放射能の総量が〇・三七ギガベクレル未満のものを除く。）

(b) Radium 226, radium 226 alloys, radium 226 compounds or radium 226 mixtures, or primary or semi-finished products thereof (excluding those incorporated into and installed in medical devices, where the total radioactivity per device is less than 0.37 gigabecquerels)

ハ アルファ線を放出する放射性核種であって、アルファ崩壊の半減期が一〇日以上二〇〇年未満のもの又はその化合物若しくは混合物（装置に内蔵された化合物又は混合物であって、一装置当たりのアルファ崩壊による放射能の総量が三・七ギガベクレル未満のものを除く。）であって、一キログラム当たりのアルファ崩壊による放射能の総量が三七ギガベクレル以上のもの

(c) Radionuclide emitting alpha rays, with an alpha decay half-life of 10 days or more and less than 200 years, or compounds or mixtures thereof (excluding those installed in equipment, for which the total radiation from alpha decay per device is less than 3.7 gigabecquerels), and with total radiation from alpha decay per kilogram of 37 gigabecquerels or more

二十五 ほう素、ほう素化合物若しくはほう素混合物又はこれらの半製品若しくは一次製品であって、ほう素一〇のほう素一〇及びほう素一一に対する比率が天然の比率を超えて濃縮されたほう素から構成されるもの又はそのほう素を含むもの

(xxv) Boron, boron compounds or boron mixtures, or primary or semi-finished products thereof, comprised of concentrated boron with a boron 10 to boron 10 and boron 11 ratio greater than the ratio in nature, or anything containing such boron

二十六 核燃料物質の製造用の還元剤又は酸化剤として用いられる物質であって、次のいずれかに該当するもの

(xxvi) Substances used as reducing or oxidizing agents for the production of nuclear fuel materials and that fall under any of the following

イ カルシウムであって、次の（一）及び（二）に該当するもの

(a) Calcium falling under the following 1. and 2.

（一） カルシウム又はマグネシウム以外の金属の含有量が全重量の〇・一パーセント未満のもの

1. Calcium with a content ratio of metals other than calcium or magnesium less than 0.1% of the total weight

（二） ほう素の含有量が全重量の〇・〇〇一パーセント未満のもの

2. Calcium with a boron content ratio less than 0.001% of the total weight

ロ 三ふっ化塩素

(b) Chlorotrifluorine

ハ マグネシウムであって、次の（一）及び（二）に該当するもの

(c) Magnesium falling under the following 1. and 2.

（一） マグネシウム又はカルシウム以外の金属の含有量が全重量の〇・〇二パーセント未満のもの

1. Magnesium with a content ratio of metals other than magnesium or calcium less than 0.02% of the total weight

（二） ほう素の含有量が全重量の〇・〇〇一パーセント未満のもの

2. Magnesium with a boron content ratio less than 0.001% of the total weight

二十七 アクチニドに対して耐食性のある材料を用いたるつぼであって、次のいずれかに該当するもの

(xxvii) Crucibles made with materials corrosion-resistant against actinide that fall under any of the following

イ 容量が〇・一五リットル超八リットル未満のるつぼであって、次のいずれかに該当する材料（重量比による純度が九八パーセント以上のものに限る。）からなるもの又はその材料により被覆されたもの

(a) Crucibles with a capacity exceeding 0.15 liters and less than 8 liters, made from or coated with any of the following (limited to those with a weight-based purity level of 98% or more)

（一） ふっ化カルシウム

1. Calcium fluoride

（二） メタジルコン酸カルシウム

2. Calcium metazirconate

（三） 硫化セリウム

3. Cerium sulfide

（四） 酸化エルビウム

4. Erbium oxide

（五） 酸化ハフニウム

5. Hafnium oxide

（六） 酸化マグネシウム

6. Magnesium oxide

（七） ニオブ、チタン及びタングステンからなる合金であって、窒化したもの

7. Nitride of alloys containing niobium, titanium and tungsten

（八） 酸化イットリウム

8. Yttrium oxide

（九） 酸化ジルコニウム

9. Zirconium oxide

ロ 容量が〇・〇五リットル超二リットル未満のるつぼであって、重量比による純度が九九・九パーセント以上のタンタル製のもの又はそのタンタルで裏打ちされたもの

(b) Crucibles with a capacity exceeding 0.05 liters and less than 2 liters, made from or lined with tantalum with a weight-based purity level of 99.9% or more

ハ 容量が〇・〇五リットル超二リットル未満のるつぼであって、重量比による純度が九八パーセント以上のタンタル製のもの又はそのタンタルで裏打ちされたもののうち、タンタルの炭化物、窒化物、ほう化物又はこれらのいずれかを組み合わせたもので被覆されたもの

(c) Among crucibles with a capacity exceeding 0.05 liters and less than 2 liters, made from or lined with tantalum with a weight-based purity level of 98% or more, those that are coated with tantalum carbide, tantalum nitride, tantalum boride, or a combination thereof

二十八 ハフニウム若しくはハフニウム合金（ハフニウムの含有量が全重量の六〇パーセントを超えるものに限る。）の地金若しくはくず若しくはハフニウム化合物（ハフニウムの含有量が全重量の六〇パーセントを超えるものに限る。）又はこれらの半製品若しくは一次製品

(xxviii) Metals, waste, or scrap of hafnium and hafnium alloys (limited to those with a hafnium content exceeding 60% of the total weight) or hafnium compounds (limited to those with hafnium content level exceeding 60% of the total weight), or primary or semi-finished products thereof

二十九 リチウム若しくはリチウム合金の地金若しくはくず若しくはリチウム化合物若しくはリチウム混合物又はこれらの半製品若しくは一次製品であって、リチウム六のリチウム六及びリチウム七に対する比率が天然の比率を超えて濃縮されたりリチウムから構成されるもの又はそのリチウムを含むもの（熱ルミネセンス線量計に組み込まれたりリチウム化合物又はリチウム混合物を除く。）

(xxix) Metals, waste or scraps of lithium or lithium alloys or lithium compounds or mixtures, or primary or semi-finished products thereof, comprising concentrated lithium with a lithium 6 to lithium 6 and lithium 7 ratio greater than the ratio in nature, or containing the lithium (excluding lithium compounds and lithium mixtures incorporated into thermo-luminescence dosimeters)

三十 タングステン、タングステンの炭化物又はタングステンの含有量が全重量の九〇パーセントを超える合金であって、質量が二〇キログラムを超え、かつ、内径が一〇〇ミリメートル超三〇〇ミリメートル未満の円筒形のもの若しくは中空の半球形のもの又はこれらを組み合わせたもの（おもり又はガンマ線のコリメータ用に設計されたものを除く。）

(xxx) Tungsten, tungsten carbide, or alloys with a tungsten content exceeding 90% of the total weight, weighing in excess of 20 kilograms, with a cylindrical shape and internal diameter exceeding 100 millimeters and less than 300 millimeters, or with a hollow hemispherical shape, and combinations of both shapes (excluding those designed for use in dead weight or gamma ray collimators)

三十一 ジルコニウム若しくはジルコニウム合金（ジルコニウムの含有量が全重量の五〇パーセントを超えるものに限る。）の地金若しくはくず若しくはジルコニウム化合物（ハフニウムの含有量がジルコニウムの含有量の五〇〇分の一未満のものに限る。）又はこれらの半製品若しくは一次製品（厚さが〇・一ミリメートル以下のはくを除く。）

(xxxix) Metals, waste, or scraps of zirconium or zirconium alloys (limited to alloys with a zirconium content exceeding 50% of the total weight), or zirconium compounds (limited to those with a hafnium content level less than 1/500 the zirconium content level), and primary or semi-finished products thereof (excluding leaf with a thickness 0.1 millimeters or less)

三十二 ふっ素製造用の電解槽であって、製造能力が一時間当たり二五〇グラムを超えるもの

(xxxix) Electrolytic cells for fluorine production with a production capability exceeding 250 grams per hour

三十三 ガス遠心分離機のロータの製造用若しくは組立用の装置又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの

(xxxix) Equipment for the production or assembly of gas centrifuge rotors, or components thereof, that fall under any of the following

イ ガス遠心分離機のロータのチューブ、バップル及びエンドキャップの組立用の装置

(a) Equipment used for assembly gas centrifuge rotor tubes, baffle and end caps

ロ ガス遠心分離機のロータのチューブの中心軸を調整するための装置

(b) Equipment used to adjust the center axis of gas centrifuge separator rotor tubes

ハ 次の（一）から（三）までのすべてに該当するベローズ（アルミニウム合金、マルエージング鋼又は繊維で強化した複合材料からなるものに限る。）の製造用のマンドレル又は型

(c) Mandrels or molds used for manufacture of bellows (limited to those made from aluminum alloys, maraging steel, or fiber-reinforced composite materials) falling under the following all of 1. through 3.

（一） 内径が七五ミリメートル超四〇〇ミリメートル未満のもの

1. Mandrels or molds with an internal diameter exceeding 75 millimeters and less than 400 millimeters

（二） 溝のピッチが一・七ミリメートル以上のもの

2. Mandrels or molds with a groove pitch of 12.7 millimeters or more

（三） 溝の深さが二ミリメートルを超えるもの

3. Mandrels or molds with a groove depth exceeding 2 millimeters

三十四 遠心力式釣合い試験機（一面釣合い試験機を除く。）であって、次のいずれかに該当するもの（第三条第十七号の三口に該当するものを除く。）

(xxxix) Centrifugal balancing machines (excluding balancing machines that can

measure unbalance on one plane) that fall under any of the following (excluding those falling under Article 3, item (xvii)-3, (b))

イ 長さが六〇〇ミリメートル以上の弾性ロータを試験することができるように設計したものであって、次の（一）から（三）までのすべてに該当するもの

(a) Centrifugal balancing machines designed to be capable of testing elastic rotors with a length of 600 millimeters or more that fall under all of the following 1. through 3.

（一） 外径が七五ミリメートルを超える弾性ロータを試験することができるもの又はジャーナルの径が七五ミリメートル以上のもの

1. Centrifugal balancing machines capable of testing elastic rotors with an external diameter exceeding 75 millimeters, or with a journal diameter of 75 millimeters or more

（二） 重量が〇・九キログラム以上二三キログラム以下の弾性ロータを試験することができるもの

2. Centrifugal balancing machines capable of testing elastic rotors with a weight of 0.9 kilograms or more and 23 kilograms or less

（三） 一分につき五、〇〇〇回転を超える回転数で試験することができるもの

3. Centrifugal balancing machines capable of testing at 5,000 rounds per minute or more

ロ 円筒形のロータを試験することができるように設計したものであって、次の（一）から（四）までのすべてに該当するもの

(b) Centrifugal balancing machines designed to be capable of testing cylindrical rotors, and that fall under all of the following 1. through 4.

（一） ジャーナルの径が七五ミリメートルを超えるもの

1. Machines with a journal diameter exceeding 75 millimeters

（二） 重量が〇・九キログラム以上二三キログラム以下のロータを試験することができるもの

2. Machines capable of testing rotors of 0.9 kilograms or more and 23 kilograms or less

（三） 修正面上の残留不釣合いが一キログラム当たり〇・〇一キログラムミリメートル以下のもの

3. Machines with a residual imbalance on the balancing plane of 0.01 kilograms millimeters or less per 1 kilogram

（四） ベルト駆動式のもの

4. Machines with a belt drive mechanism

三十五 フィラメントワインディング装置であって、次のイ及びロに該当するもの又はその制御装置若しくはマンドレル

(xxxv) Filament winding machines falling under the following (a) and (b), or controllers thereof or mandrels

イ 繊維を位置決めし、包み及び巻く作業を行うもののうち、それらの作業を相関して制御することができる軸数が二以上のもの

(a) Among machines that perform positioning on filaments and carry out wrapping and winding operations, those with 2 or more axes capable of controlling both these operations in coordination

ロ 直径が七五ミリメートル超四〇〇ミリメートル未満であって、かつ、長さが六〇〇ミリメートル以上の円筒形のロータを製造することができるもの

(b) Machines capable of manufacturing cylindrical rotors with a diameter exceeding 75 millimeters and less than 400 millimeters and a length of 600 millimeters or more

三十六 ガスレーザー発振器、固体レーザー発振器又は色素レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの

(xxxvi) Gas laser oscillators, solid-state laser oscillators or dye laser oscillators that fall under any of the following

イ 五〇〇ナノメートル超六〇〇ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計した金属蒸気レーザー発振器（銅レーザー発振器に限る。）であって、平均出力が四〇ワット以上のもの

(a) Metal vapor laser oscillators (limited to copper laser oscillators) designed for use within a wavelength range exceeding 500 nanometers and less than 600 nanometers, with an average output of 40 watts or more

ロ 四〇〇ナノメートル超五一五ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計したアルゴンイオンレーザー発振器であって、平均出力が四〇ワットを超えるもの

(b) Argon ion laser oscillators designed for use within a wavelength range exceeding 400 nanometers and less than 515 nanometers, with an average output exceeding 40 watts

ハ 九、〇〇〇ナノメートル超一一、〇〇〇ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計した二酸化炭素レーザー発振器であって、パルスを発振するように設計したもののうち、次の（一）から（三）までのすべてに該当するもの

(c) Among carbon dioxide laser oscillators designed for use within a wavelength range exceeding 9,000 nanometers and less than 11,000 nanometers, designed to generate a pulse, those falling under all of the following 1. through 3.

（一） パルス繰り返し周波数が二五〇ヘルツを超えるもの

1. Oscillators with a pulse repetition frequency exceeding 250 hertz

（二） 平均出力が五〇〇ワットを超えるもの

2. Oscillators with an average output exceeding 500 watts

（三） パルス幅が二〇〇ナノ秒未満のもの

3. Oscillators with a pulse width of 200 nanoseconds or less

ニ 二四〇ナノメートル超三六〇ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計したエキシマーレーザー発振器であって、パルスを発振するように設計したもののうち、次の（一）及び（二）に該当するもの

(d) Among excimer laser oscillators designed for use within a wavelength

range exceeding 240 nanometers and less than 360 nanometers, and designed to generate a pulse, those falling under the following 1. and 2.

(一) パルス繰返し周波数が二五〇ヘルツを超えるもの

1. Oscillators with a pulse repetition frequency exceeding 250 hertz

(二) 平均出力が五〇〇ワットを超えるもの

2. Oscillators with an average output exceeding 500 watts

ホ 一六マイクロメートルの波長で用いるように設計したパラ水素を用いたラマンレーザー発振器であって、パルス繰返し周波数が二五〇ヘルツを超えるもの

(e) Raman laser oscillators utilizing parahydrogen and designed for use at a wavelength of 16 micrometers, with a pulse repetition frequency exceeding 250 hertz

ヘ 七二〇ナノメートル超八〇〇ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計したアレキサンドライトレーザー発振器であって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの

(f) Alexandrite laser oscillators designed for use within a wavelength range exceeding 720 nanometers and less than 800 nanometers that fall under all of the following 1. through 3.

(一) パルス繰返し周波数が一二五ヘルツを超えるもの

1. Oscillators with a pulse repetition frequency exceeding 125 hertz

(二) 平均出力が三〇ワットを超えるもの

2. Oscillators with an average output exceeding 30 watts

(三) レーザー光のスペクトル線幅が〇・〇〇五ナノメートル以下のもの

3. Oscillators with a laser beam spectral line width of 0.005 nanometers or less

ト 一、〇〇〇ナノメートル超一、一〇〇ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計したネオジウムを添加した固体レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの(ネオジウムガラスレーザー発振器を除く。)

(g) Fixed laser oscillators with neodymium added, designed for use within a wavelength range exceeding 1,000 nanometers and less than 1,100 nanometers that fall under any of the following (excluding neodymium glass laser oscillators)

(一) パルス励起及びキュースイッチを用いたものであって、一ナノ秒以上のパルス幅のパルスを発振するものうち、次のいずれかに該当するもの

1. Among oscillators utilizing pulse excitation and a Q-switch and emitting a pulse with a pulse width of 1 nanosecond or more, those falling under any of the following

1 単一横モードのパルスを発振するものであって、平均出力が四〇ワットを超えるもの

i. Oscillators emitting a single-transverse-mode pulse, and with an average output exceeding 40 watts

2 多重横モードのパルスを発振するものであって、平均出力が五〇ワットを

超えるもの

ii. Oscillators emitting a multi-transverse-mode pulse, and with an average output exceeding 50W

(二) 波長範囲が五〇〇ナノメートル超五五〇ナノメートル未満で、かつ、平均出力が四〇ワットを超える第二高調波を発生するように設計したもの

2. Oscillators designed to generate a second harmonic within the frequency range exceeding 500 nanometers and less than 550 nanometers, and with an average output exceeding 40 watts

チ 三〇〇ナノメートル超八〇〇ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計した色素レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの

(h) Dye laser oscillators designed for use within a wavelength range exceeding 300 nanometers and less than 800 nanometers that fall under any of the following

(一) 単一モードのパルスを発振する波長可変レーザー発振器（レーザー光の増幅のみを行う装置を除く。）であって、次の1から3までのすべてに該当するもの

1. Variable wavelength laser oscillators emitting a single-mode pulse (excluding equipment that only performs laser beam amplification) that fall under all of the following i. through iii.

1 パルス繰返し周波数が一キロヘルツを超えるもの

i. Oscillators with a pulse repetition frequency exceeding 1 kilohertz

2 平均出力が一ワットを超えるもの

ii. Oscillators with an average output exceeding 1 watt

3 パルス幅が一〇〇ナノ秒未満のもの

iii. Oscillators with a pulse width less than 100 nanoseconds

(二) パルスを発振する波長可変レーザー発振器であって、次の1から3までのすべてに該当するもの（（一）に該当するものを除く。）

2. Variable wavelength oscillator emitting a pulse that fall under all of the following i. through iii. (excluding those falling under 1.)

1 パルス繰返し周波数が一キロヘルツを超えるもの

i. Oscillators with a pulse repetition frequency exceeding 1 kilohertz

2 平均出力が三〇ワットを超えるもの

ii. Oscillators with an average output exceeding 30 watts

3 パルス幅が一〇〇ナノ秒未満のもの

iii. Oscillators with a pulse width less than 100 nanoseconds

三十七 質量分析計であって、原子質量単位で表した質量が二三〇以上のイオンを測定することができ、かつ、原子質量の差が二未満のイオンを区別することができるもののうち、次のイからへまでのいずれかに該当するもの（トに該当するものを除く。）又は当該質量分析計に用いることができるイオン源

(xxxvii) Among mass spectrometers, capable of measuring ions with a mass of 230 or more expressed in atomic weight units, and capable of differentiating



ions with an atomic weight difference less than 2, those falling under any of the following (a) through (f) (excluding those falling under (g)) or ion sources usable with the mass spectrometers

イ 誘導結合プラズマを用いたもの

(a) Mass spectrometers utilizing inductively-coupled plasma

ロ グロー放電を用いたもの

(b) Mass spectrometers utilizing glow discharge

ハ 熱電離を用いたもの

(c) Mass spectrometers utilizing thermal ionization

ニ 分析される物質に電子を衝突させてイオン化するイオン源を有するものであって、イオン化室が六ふっ化ウランに対して耐食性のある材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの

(d) Mass spectrometers possessing an ion source that ionizes by bombarding the materials under analysis with electrons, having an ionization chamber comprised of, lined or coated with materials corrosion-resistant against uranium hexafluoride

ホ 分析される物質の分子線を用いてイオン化するイオン源を有するものであって、次のいずれかに該当するもの

(e) Mass spectrometers possessing an ion source that ionizes utilizing a molecular beam of the materials under analysis that fall under any of the following

(一) 零下八〇度以下の温度となることができるコールドトラップ及びステンレス鋼若しくはモリブデンで構成され、裏打ちされ、又は被覆されたイオン化室を有するもの

1. Mass spectrometers possessing a cold trap capable of temperatures at - 80 degrees centigrade or less and an ionization chamber made of, lined or coated with stainless steel and molybdenum

(二) イオン化室が六ふっ化ウランに対して耐食性のある材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの

2. Mass spectrometers possessing an ionization chamber comprised of, lined or coated with materials corrosion-resistant against uranium hexafluoride

ヘ アクチニド又はそのふっ化物のイオン化用に設計したイオン源を有するもの

(f) Mass spectrometers possessing an ion source designed for ionization of actinides or fluorides thereof

ト 磁石又は四重極を用いたものであって、次の(一)から(五)までのすべてに該当するもの

(g) Mass spectrometers utilizing magnets or quadrupoles, that fall under all of the following 1. through 5.

(一) 原子質量単位で表した質量が三二〇を超えるイオンを測定することができるもの

1. Mass spectrometers capable of measuring ions with a mass exceeding 320, expressed in atomic weight units
  - (二) イオン源が、ニクロム若しくはモネルで構成され、若しくは裏打ちされたもの又はニッケルで被覆されたもの
2. Mass spectrometers possessing an ion source comprised of, or lined with nichrome or monel, or coated with nickel
  - (三) 分析される物質に電子を衝突させてイオン化するイオン源を有するもの
3. Mass spectrometers possessing an ion source that ionizes by bombarding the materials under analysis with electrons
  - (四) 同位元素の分析に用いることができるコレクタを有するもの
4. Mass spectrometers possessing a collector usable for isotope analysis
  - (五) 六ふっ化ウランのガスの流れを止めずに試料を採取することができるように設計したもの
5. Mass spectrometers capable of taking samples without stopping the flow of uranium hexafluoride gas

三十八 圧力計又はベローズ弁であって、次のいずれかに該当するもの

(xxxviii) Pressure gauges or bellows valves that fall under any of the following  
 イ アルミニウム製、アルミニウム合金製、ニッケル製又はニッケルの含有量が全重量の六〇パーセントを超えるニッケル合金製のセンサを用いた絶対圧力計であって、次のいずれかに該当するもの

- (a) Absolute pressure gauges utilizing a sensor made from aluminum, aluminum alloys, nickel or nickel alloys with a nickel content exceeding 60% of the total weight that fall under any of the following
  - (一) 測定できる最大の測定レンジが一三キロパスカル未満のものであって、測定できる最大の測定レンジにおいて、精度が一パーセント未満のもの
  1. Absolute pressure gauges with a maximum measurable measurement range less than 13 kilopascals, with a precision less than 1% within the maximum measurable measurement range
  - (二) 測定できる最大の測定レンジが一三キロパスカル以上のものであって、精度が一三〇パスカル未満のもの
  2. Absolute pressure gauges with a maximum measurable measurement range of 13 kilopascals or more and a precision less than 130 pascals
- ロ ベローズ弁であって、直径の最小値が五ミリメートル以上のもののうち、アルミニウム、アルミニウム合金、ニッケル又はニッケル合金（ニッケルの含有量が全重量の六〇パーセントを超えるものに限る。）で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの
- (b) Bellows valves with a minimum diameter value of 5 millimeters or more, comprised of, lined with or coated with aluminum, aluminum alloys, nickel or nickel alloys (limited to those with a nickel content exceeding 60% of the total weight)

三十九 ソレノイドコイル形の超電導電磁石であって、次のイからニまでのすべてに

該当するもの（医療用の磁気共鳴イメージング装置に用いるように設計したものを除く。）

(xxxix) Superconducting solenoid electromagnets that fall under all of the following (a) through (d) (excluding those designed for use of clinical magnetic resonance equipment)

イ 磁束密度が二テスラを超えるもの

(a) Superconducting solenoid electromagnets with magnetic flux density exceeding 2 teslas

ロ コイルの長さを内径で除した値が二を超えるもの

(b) Superconducting solenoid electromagnets, the coil length of which divided by an internal diameter exceeds 2

ハ コイルの内径が三〇〇ミリメートルを超えるもの

(c) Superconducting solenoid electromagnets with a coil internal diameter exceeding 300 millimeters

ニ コイルの軸の中心部分を中心として内径の三五パーセントを半径とする円であって、コイルの軸に垂直なものの範囲において、磁界の均一性が一パーセント未満のもの

(d) A circle with the radius of 35% of the internal diameter, centered on the center of the coil axis, and with a magnetic field homogeneity less than 1% within the range of those perpendicular to the coil axis

四十 真空ポンプであって、吸気口の内径が三八センチメートル以上のもののうち、排気速度が一秒当たり一五、〇〇〇リットル以上で、かつ、到達圧力が一三・三ミリパスカル未満のもの

(xl) Among vacuum pumps with an intake internal diameter of 38 centimeters or more, those with an exhaust speed of 15,000 liters or more per second and an ultimate pressure less than 13.3 millipascals

四十一 直流の電源装置であって、次のいずれかに該当するもの

(xli) Direct current power units falling under any of the following

イ 出力電流が五〇〇アンペア以上のもののうち、電流又は電圧の変動率が〇・一パーセント未満で、かつ、出力電圧が一〇〇ボルト以上の状態で連続八時間を超えて使用することができるもの

(a) Among direct current power units with an output current of 500 amperes or more, those with a current or voltage fluctuation rate less than 0.1%, and capable of use for exceeding 8 consecutive hours under an output voltage of 100 volts or more

ロ 出力電圧が二〇、〇〇〇ボルト以上のもののうち、電流又は電圧の変動率が〇・一パーセント未満で、かつ、出力電流が一アンペア以上の状態で連続八時間を超えて使用することができるもの

(b) Among direct current power units with an output voltage of 20,000 volts or more, those with a current or voltage fluctuation rate less than 0.1%, and capable of use for exceeding 8 consecutive hours with an output

current of 1 ampere or more

四十二 電子加速器又はフラッシュ放電型のエックス線装置であって、次のいずれかに該当するもの（電子顕微鏡の部分品又は医療用装置を除く。）

(xlii) Electron accelerators or flash X-ray generators falling under any of the following (excluding electron microscope components and medical equipment)

イ 電子の運動エネルギーのせん頭値が〇・五メガ電子ボルト以上二五メガ電子ボルト未満であって、次のいずれかに該当するもの

(a) Electron accelerators or flash X-ray generators with a peak value for electron kinetic energy of 0.5 megaelectron volts or more and less than 25 megaelectron volts, and that fall under any of the following

(一) ビームのパルスの持続時間が一マイクロ秒以下であって、一、七〇〇にメガ電子ボルトで表した電子の運動エネルギーのせん頭値の二・六五乗を乗じたものに、クーロンで表した加速された電子の全電荷量を乗じた値が〇・二五以上のもの

1. Electron accelerators or flash X-ray generators with a beam pulse duration of 1 microsecond or less, and with a value of 0.25 or more when 1,700 is multiplied by the result of multiplying the peak value of electron kinetic energy expressed in megaelectron volts raised to the 2.65 power by the total charge quantity of accelerated electrons, expressed in coulombs

(二) ビームのパルスの持続時間が一マイクロ秒を超えるものであって、一、七〇〇にメガ電子ボルトで表した電子の運動エネルギーのせん頭値の二・六五乗を乗じたものに、クーロンで表した一マイクロ秒の間に加速することができる電荷量の最大値を乗じた値が〇・二五以上のもの

2. Electron accelerators or flash X-ray generators with a beam pulse duration exceeding 1 microsecond, and having a value of 0.25 or more when 1,700 is multiplied by the result of multiplying the peak value of electron kinetic energy expressed in megaelectron volts raised to the 2.65 power is multiplied by the maximum charge quantity of electrons accelerated for 1 microsecond, expressed in coulombs

ロ 電子の運動エネルギーのせん頭値が二五メガ電子ボルト以上であって、せん頭出力が五〇メガワットを超えるもの

(b) Electron accelerators or flash X-ray generators with a peak electron kinetic energy of 25 megaelectron volts or more and a peak output exceeding 50 megawatts

四十三 発射体の速度の最大値を一秒につき二キロメートル以上にすることができる衝撃試験機

(xliii) Impact testing machines capable of supporting a maximum projectiles velocity of 2 kilometers per second or more

四十四 機械式若しくは電子式のストリークカメラ若しくはフレーミングカメラ又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの

(xliv) Mechanical or electronic streak cameras or framing cameras or components thereof that fall under any of the following

イ 機械式のストリークカメラ又はフレーミングカメラであって、回転反射鏡を用いたもののうち、次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品

(a) Mechanical streak cameras or framing cameras, utilizing a rotating reflector, that fall under any of the following, or components thereof

(一) ストリークカメラであって、撮影速度が一マイクロ秒につき〇・五ミリメートルを超えるもの

1. Streak cameras with a photographing speed exceeding 0.5 millimeters per microsecond

(二) フレーミングカメラであって、撮影速度が一秒につき二二五、〇〇〇こまを超えるもの

2. Framing cameras with a photographing speed exceeding 225,000 frames per second

ロ 電子式のストリークカメラ若しくはフレーミングカメラ（電気制動シャッターを用いたものを含む。）又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの

(b) Electronic streak cameras or framing cameras (including those utilizing electrically triggered shutters) and components thereof and that fall under any of the following

(一) ストリークカメラ又はストリーク管であって、時間分解能が五〇ナノ秒以下のもの

1. Streak cameras or streak tubes with a time resolution of 50 nanoseconds or less

(二) フレーミングカメラ（電気制動シャッターを用いたものを含む。）であって、シャッター速度が五〇ナノ秒以下のもの

2. Framing cameras (including those utilizing electrically triggered shutters) and with a shutter speed of 50 nanoseconds or less

(三) (二)に該当するフレーミングカメラ用の固体撮像素子又は電子管（(四)に該当するものを除く。）であって、シャッター速度が五〇ナノ秒未満のもの

3. Fixed imaging elements or electron tubes for framing cameras falling under 2. (excluding those falling under 4.) and with a shutter speed less than 50 nanoseconds

(四) (二)に該当するフレーミングカメラに用いることができる電子管又は電気制動シャッターであって、次のいずれかに該当するもの

4. Electron tubes and electrically triggered shutters usable in framing cameras falling under 2. and that fall under any of the following

1 イメージ増強管であって、導電材料で被覆した光電陰極を有するもの

i. Image intensifier tubes possessing a photocathode coated with electrical conductive materials

- 2 SIT管であつて、シャッターの機能を有するもの
  - ii. SIT tubes having shutter capabilities
  - 3 カーセル又はポッケルスセルを用いた電気制動シャッター
  - iii. Electrically triggered shutters utilizing Kerr cells or Pockel cells
- 四十五 流体の速度を測定するための干渉計、マンガニンを用いた圧力測定器又は水晶圧電型圧力センサを用いた圧力変換器であつて、次のいずれかに該当するもの
- (xlv) Interferometers for measuring fluid velocities, manganin pressure gauges, or quartz pressure transducers that fall under any of the following
- イ 流体の速度を測定するための干渉計であつて、次の（一）及び（二）に該当するもの
    - (a) Interferometers for measuring fluid speeds falling under the following 1. and 2.
      - （一） 一秒につき一キロメートルを超える速度を測定することができるもの
      - 1. Interferometers capable of measuring speeds exceeding 1 kilometers per second
      - （二） 一〇マイクロ秒未満の間隔で速度を測定することができるもの
      - 2. Interferometers capable of measuring speeds at intervals less than 10 microseconds
    - ロ 流体の圧力を測定することができるマンガニンを用いた圧力測定器又は水晶圧電型圧力センサを用いた圧力変換器であつて、一〇ギガパスカルを超える圧力を測定することができるもの
  - (b) Manganin pressure gauges capable of measuring fluid pressure, or quartz pressure transducers, capable of measuring pressures exceeding 10 gigapascals
- 四十六 三個以上の電極を有する冷陰極管であつて、次のイからハまでのすべてに該当するもの
- (xlvi) Cold-cathode tubes having 3 or more electrodes and that fall under all of the following (a) through (c)
- イ せん頭陽極電圧が二、五〇〇ボルト以上のもの
  - (a) Cold-cathode tubes with a peak anode voltage of 2,500 volts or more
  - ロ せん頭陽極電流が一〇〇アンペア以上のもの
  - (b) Cold-cathode tubes with a peak anode current of 100 amperes or more
  - ハ 陽極遅延時間が一〇マイクロ秒以下のもの
  - (c) Cold-cathode tubes with a anode delay time of 10 microseconds or less
- 四十七 トリガー火花間げきであつて、陽極遅延時間が一五マイクロ秒以下のもののうち、せん頭電流が五〇〇アンペア以上のもの
- (xlvii) Among trigger spark gaps with a cathode delay time of 15 microseconds or less, those with a peak current of 500 amperes or more
- 四十八 スイッチングを行う機能を有する組立品であつて、次のイからハまでのすべてに該当するもの
- (xlviii) Assemblies having switching capabilities that fall under all of the

following (a) through (c)

イ セン頭陽極電圧が二、〇〇〇ボルトを超えるもの

(a) Assemblies with a peak anode voltage exceeding 2,000 volts

ロ セン頭陽極電流が五〇〇アンペア以上のもの

(b) Assemblies with a peak anode current of 500 amperes or more

ハ ターンオン時間が一マイクロ秒以下のもの

(c) Assemblies with a turn-on time of 1 microsecond or less

四十九 パルス用コンデンサであって、次のいずれかに該当するもの

(xlix) Pulse condensers falling under any of the following

イ 定格電圧が一、四〇〇ボルトを超えるものであって、次の (一) から (三) までのすべてに該当するもの

(a) Pulse condensers possessing a rated voltage exceeding 1,400 volts that fall under all of the following 1. through 3.

(一) 総エネルギーが一〇ジュールを超えるもの

1. Pulse condensers with a total energy exceeding 10 joules

(二) 公称静電容量が〇・五マイクロファラドを超えるもの

2. Pulse condensers with a nominal capacitance exceeding 0.5 microfarads

(三) 直列インダクタンスが五〇ナノヘンリー未満のもの

3. Pulse condensers with series inductance less than 50 nanohenries

ロ 定格電圧が七五〇ボルトを超えるものであって、次の (一) 及び (二) に該当するもの

(b) Pulse condensers with a rated voltage exceeding 750 volts, and that fall under the following 1. and 2.

(一) 公称静電容量が〇・二五マイクロファラドを超えるもの

1. Pulse condensers with a nominal capacitance exceeding 0.25 microfarads

(二) 直列インダクタンスが一〇ナノヘンリー未満のもの

2. Pulse condensers with series inductance less than 10 nanohenries

五十 パルス発生器又はキセノンせん光ランプの発光装置であって、次のいずれかに該当するもの

(l) Pulse generators or xenon flashlamp drivers that fall under any of the following

イ モジュール方式のパルス発生器又はキセノンせん光ランプの発光装置であって、次の (一) から (六) までのすべてに該当するもの

(a) Modular pulse generators or xenon flashlamp drivers that fall under all of the following 1. through 6.

(一) 一五マイクロ秒未満の時間でパルスを供給することができるもの

1. Modular pulse generators or xenon flashlamp drivers capable of supplying a pulse for less than 15 microseconds

(二) 出力が一〇〇アンペアを超えるもの

2. Modular pulse generators or xenon flashlamp drivers with an output exceeding 100 amperes

- (三) 四〇オーム未満の抵抗負荷に対して一〇マイクロ秒未満のパルス立上がり時間を要するもの
3. Modular pulse generators or xenon flashlamp drivers that require pulse rise times less than 10 microseconds against a resistance load less than 40 ohms
- (四) 寸法の最大値が二五・四センチメートル以下のもの
4. Modular pulse generators or xenon flashlamp drivers with the largest dimensional value of 25.4 centimeters or less
- (五) 重量が二五キログラム未満のもの
5. Modular pulse generators or xenon flashlamp drivers with a weight less than 25 kilograms
- (六) 零下五〇度より低い温度から一〇〇度を超える温度まで用いることができるように設計したもの又は宇宙で用いることができるように設計したもの
6. Modular pulse generators or xenon flashlamp drivers designed to be usable from below -50 degrees centigrade to over 100 degrees centigrade, or designed to be usable for space use
- ロ パルス発生器であって、五五オーム未満の抵抗負荷に対して六ボルトを超える電圧のパルスを発生し、かつ、五〇〇ピコ秒未満のパルス立上がり時間を要するもの（イに該当するものを除く。）
- (b) Pulse generators generating pulses with voltage exceeding 6 volts against a resistance load less than 55 ohms, and requiring a pulse rise time less than 500 picoseconds (excluding those falling under (a))

五十一 削除

(li) Deleted

五十二 光電子増倍管であって、光陰極の面積が二〇平方センチメートルを超えるもののうち、陽極パルス立上がり時間が一ナノ秒未満のもの

(lii) Among photomultiplier tubes with photocathode area exceeding 20 square centimeters, those with an anode pulse rise time less than 1 nanosecond

五十三 トリチウムと重水素との核反応による静電加速型の中性子発生装置であって、真空ポンプを使用しないで操作できるように設計したもの

(liii) Neutron generators utilizing electrostatic acceleration to induce a tritium-deuterium nuclear reaction designed to be operable without using a vacuum pump

五十四 放射線被ばくの防止のために用いられる遠隔操作のマニピュレーターであって、厚さ〇・六メートル以上の放射線を遮へいする壁を隔てて操作することができるもの

(liv) Remote manipulators used in the prevention of radioactive exposure, and operable behind a radiation shielding wall with a thickness of 0.6 meters or more

五十五 放射線を遮へいするように設計した窓であって、次のイからハまでのすべてに該当するもの又はその窓枠



(lv) Radiation shielding windows and that fall under all of the following (a) through (c), or frames thereof

イ コールドエリア側に露出する面の面積が〇・〇九平方メートルを超えるもの

(a) Windows with an area exceeding 0.09 square meters for the surface that protrudes into the cold area

ロ 密度が一立方センチメートル当たり三グラムを超える材料を用いたもの

(b) Windows made from materials with a density exceeding 3 grams per cubic centimeters

ハ 厚さが一〇〇ミリメートル以上のもの

(c) Windows with a thickness of 100 millimeters or more

五十六 放射線による影響を防止するように設計したテレビカメラ又はそのレンズであって、全吸収線量がシリコン換算で五〇、〇〇〇グレイを超える放射線照射に耐えることができるもの

(lvi) TV cameras or lenses specially designed for protection from the influence of radiation, and capable of withstanding radiation with total absorption exceeding 50,000 grays on a silicon conversion basis

五十七 トリチウム、トリチウム化合物又はトリチウム混合物であって、トリチウムの原子数の水素の原子数に対する比率が一、〇〇〇分の一を超えるもの（装置に内蔵されたものであって、一装置当たりの放射能の総量が一、四八〇ギガベクレル未満のものを除く。）

(lvii) Tritium, tritium compounds or tritium mixtures, with a ratio of tritium atomicity to hydrogen atomicity exceeding 1/1,000 (excluding those installed in equipment, with total radioactivity per 1 equipment less than 1,480 gigabecquerels)

五十八 トリチウムの製造、回収又は貯蔵に用いられる装置であって、次のいずれかに該当するもの

(lviii) Equipment used for the production, collection or preservation of tritium that falls under any of the following

イ トリチウムの製造用（濃縮用を含む。）、回収用又は貯蔵用に設計した装置

(a) Equipment designed for the production (including that for concentration), collection or preservation of tritium

ロ トリチウムの製造、回収又は貯蔵に用いられる装置であって、次のいずれかに該当するもの（イに該当するものを除く。）

(b) Equipment used for the production, collection or preservation of tritium that falls under any of the following (excluding that falling under (a))

(一) 水素又はヘリウムを零下二五〇度以下の温度に冷却することができる冷凍装置であって、冷凍能力が一五〇ワットを超えるもの

1. Freezing equipment capable of cooling hydrogen or helium to -250 degrees centigrade or less, and with a freezing capacity exceeding 150 watts

(二) 水素の同位元素の貯蔵用の装置であって、金属水素化物を貯蔵のための

媒体として用いるもの

2. Equipment for the storage of hydrogen isotopes that utilizes metal hydrides as storage catalyst

五十九 重水からトリチウムを回収するため又は重水を製造するための白金を用いた触媒であって、水素と水との間で行われる水素の同位体交換を促進するために設計したもの

(lix) Platinized catalysts for the collection of tritium from heavy water or for the production of heavy water, and designed to promote hydrogen isotope exchange between hydrogen and water

六十 ヘリウム三の混合率が天然の混合率を超えるヘリウム（容器又は装置に密封されたヘリウム三であって、その重量が一グラム未満のものを除く。）

(lx) Helium with a helium-3 mixing rate greater than the mixing rate in nature (excluding helium-3 sealed in containers or equipment with a weight less than 1 gram)

第二条 輸出令別表第一の三の項（一）の経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

Article 2 (1) Goods specified by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 3 (i) of the appended table 1 of the Export Order shall fall under any of the following.

一 軍用の化学製剤の原料となる物質として、次のいずれかに該当するもの又はこれらの物質を含む混合物であって、いずれかの物質の含有量が全重量の三〇パーセントを超えるもの

(i) Substances for raw materials of chemical warfare agents falling under any of the following or mixtures containing the substances, wherein the content of any of the substances exceeds 30 % of the total weight

イ 三—ヒドロキシ——メチルピペリジン

(a) 3-hydroxy-1-methylpiperidine

ロ フッ化カリウム

(b) Potassium fluoride

ハ エチレンクロロヒドリン

(c) Ethylene chlorohydrin

ニ ジメチルアミン

(d) Dimethylamine

ホ 塩酸ジメチルアミン

(e) Dimethylamine hydrochloride

ヘ フッ化水素

(f) Hydrogen fluoride

ト ベンジル酸メチル

(g) Methyl benzilate

チ 三—キヌクリジノン

- (h) 3-quinuclidinone  
リ ピナコロン
- (i) Pinacolone  
ヌ シアン化カリウム
- (j) Potassium cyanide  
ル 一水素二フッ化カリウム
- (k) Potassium bifluoride  
ヲ 一水素二フッ化アンモニウム
- (l) Ammonium bifluoride  
ワ 一水素二フッ化ナトリウム
- (m) Sodium bifluoride  
カ フッ化ナトリウム
- (n) Sodium fluoride  
ヨ シアン化ナトリウム
- (o) Sodium cyanide  
タ 五硫化リン
- (p) Phosphorous pentasulfide  
レ ジイソプロピルアミン
- (q) Diisopropylamine  
ソ ニージエチルアミノエタノール
- (r) 2-diethylamino ethanol  
ツ 硫化ナトリウム
- (s) Sodium sulfide  
ネ トリエタノールアミン塩酸塩
- (t) Triethanolamine hydrochloride  
ナ ジエチルチオリン酸
- (u) Diethyl thiophosphoric acid  
ラ ジエチルジチオリン酸
- (v) Diethyl dithio phosphoric acid  
ム ヘキサフルオロケイ酸ナトリウム
- (w) Sodium hexafluorosilicic acid  
ウ 亜リン酸トリエチル
- (x) Phosphorous acid triisopropyl

二 軍用の化学製剤と同等の毒性を有する物質として、次のいずれかに該当するもの又はこれらの物質を含む混合物（ハからリまでに該当する物質を含む混合物にあつては、ハからホまでに該当するいずれかの物質の含有量が全重量の一パーセントを超えるもの又はハからリまでに該当するいずれかの物質の含有量が全重量の三〇パーセントを超えるものに限る。）

- (ii) Substances having equivalent toxic ability with chemical warfare agents falling under any of the following or mixtures containing such a substance (for mixtures containing a substance falling under (c) through (e), limited to

those for which the content of said substance exceeds 1 % of the total weight, and for mixtures containing a substance falling under (f) through (i), limited to those for which the content of the substance exceeds 30 % of the total weight)

イ サキシトキシン

(a) Saxitoxin

ロ リシン

(b) Lysin

ハ  $\text{O} \cdot \text{O} - \text{ジエチル} = \text{S} - [\text{二} - (\text{ジエチルアミノ}) \text{エチル}] = \text{ホスホロチオラート}$ 並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類

(c)  $\text{O}, \text{O} - \text{diethyl} = \text{S} - [2 - (\text{diethylamino}) \text{ethyl}] = \text{phosphorothiolate and alkylate salts and protonate salts thereof}$

ニ  $一 \cdot 一 \cdot 三 \cdot 三 \cdot 三 - \text{ペンタフルオロ} - \text{二} - (\text{トリフルオロメチル}) - \text{一} - \text{プロペン}$

(d) 1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluoromethyl)-1-propane

ホ  $三 - \text{キノクリジニル} = \text{ベンジラート}$

(e) 3-quinuclidinyl = benzilate

ヘ  $二 \text{塩化カルボニル}$

(f) Carbonyl dichloride

ト  $塩化シアン$

(g) Cyanogen chloride

チ  $シアン化水素$

(h) Hydrogen cyanide

リ  $トリクロロニトロメタン$

(i) Trichloronitromethane

三 軍用の化学製剤と同等の毒性を有する物質の原料となる物質として、次のいずれかに該当するもの又はこれらの物質を含む混合物（へからやまでに該当する物質を含む混合物にあっては、へからたままでに該当するいずれかの物質の含有量が全重量の一〇パーセントを超えるもの又はレからやまでに該当するいずれかの物質の含有量が全重量の三〇パーセントを超えるものに限る。）

(iii) Substances having equivalent toxic ability with chemical warfare agents falling under any of the following or mixtures containing the substances (for mixtures containing substances falling under (f) through (p), limited to those for which the content of said substance exceeds 10 % of the total weight, and for mixtures containing a substance falling under categories (q) through (cc), limited to those for which the content of said substance exceeds 30 % of the total weight)

イ アルキルホスホニルジフルオリド（アルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。）

(a) Alkyl phosphonyl difluoride (limited to those having an alkyl group carbon number of 3 or less)

- ロ O—アルキル＝O—二—ジアルキルアミノエチル＝アルキルホスホニット（O—アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、O—アルキルのアルキル基の炭素数が十以下であり、かつ、O—二—ジアルキルアミノエチル及びアルキルホスホニットのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。）並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類
- (b) O-alkyl = O-2-dialkylaminoethyl = alkyl phosphonite (including those O-alkyl alkyl group of which is a cycloalkyl group, though limited to those O-alkyl alkyl group carbon number of which is 10 or less and O-2-dialkylaminoethyl or alkyl phosphonite alkyl group carbon number of which is 3 or less) as well as alkylate salts and protonate salts thereof
- ハ O—二—ジアルキルアミノエチル＝ヒドロゲン＝アルキルホスホニット（O—二—ジアルキルアミノエチル及びアルキルホスホニットのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。）並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類
- (c) O-2-dialkylaminoethyl = hydrogen = alkyl phosphonite (limited to those O-2-dialkylaminoethyl or alkyl phosphonite alkyl group carbon number of which is 3 or less) as well as alkylate salts and protonate salts thereof
- ニ O—イソプロピル＝メチルホスホクロリダート
- (d) O-isopropyl = methyl phosphonochloridate
- ホ O—ピナコリル＝メチルホスホクロリダート
- (e) O-pinacolyl = methyl phosphonochloridate
- へ 炭素数が三以下である一のアルキル基との結合以外に炭素原子との結合のないりん原子を含む化合物
- (f) Compounds containing phosphorus atoms having no bond with a carbon atom other than a bond with one alkyl group carbon number of which is 3 or less
- ト N・N—ジアルキルホスホルアミジク＝ジハリド（アルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。）
- (g) N,N-dialkyl phosphoramidic = dihalide (limited to those with alkyl group carbon number of 3 or less)
- チ ジアルキル＝N・N—ジアルキルホスホルアミダート（ジアルキル及びN・N—ジアルキルホスホルアミダートのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。）
- (h) Dialkyl = N,N-dialkyl phosphoramidate (limited to those with dialkyl or N,N-dialkyl phosphoramidate alkyl group carbon number of 3 or less)
- リ 三塩化ヒ素
- (i) Arsenic trichloride
- ヌ 二・二—ジフェニル—二—ヒドロキシ酢酸
- (j) 2,2-diphenyl-2-hydroxyacetic acid
- ル キヌクリジン—三—オール
- (k) Quinuclidine-3-ol
- ヲ N・N—ジアルキルアミノエチル—二—クロリド（アルキル基の炭素数が三以

- 下であるものに限る。) 及びそのプロトン化塩類
- (l) N,N-dialkylaminoethyl-2-chloride (limited to those alkyl group carbon number of which is 3 or less) and protonate salts thereof  
 ワ N・N-ジアルキルアミノエタン-2-オール (アルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。) 及びそのプロトン化塩類
- (m) N,N-dialkyl aminoethane-2-ol (limited to those alkyl group carbon number of which is 3 or less) and protonate salts thereof  
 カ N・N-ジアルキルアミノエタン-2-オール (アルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。) 及びそのプロトン化塩類
- (n) N,N-dialkyl aminoethane-2-thiol (limited to those alkyl group carbon number of which is 3 or less) and protonate salts thereof  
 ヨ ビス (2-ヒドロキシエチル) スルフィド
- (o) Bis(2-hydroxyethyl) sulfide  
 タ 三・三-ジメチルブタン-2-オール
- (p) 3,3-dimethylbutane-2-ol  
 レ 塩化ホスホリル
- (q) Phosphoryl chloride  
 ソ 三塩化リン
- (r) Phosphorous trichloride  
 ツ 五塩化リン
- (s) Phosphorous pentachloride  
 ネ 亜リン酸トリメチル
- (t) Trimethyl phosphite  
 ナ 亜リン酸トリエチル
- (u) Triethyl phosphite  
 ラ 亜リン酸ジメチル
- (v) Dimethyl phosphite  
 ム 亜リン酸ジエチル
- (w) Diethyl phosphite  
 ウ 一塩化硫黄
- (x) Sulfur monochloride  
 キ 二塩化硫黄
- (y) Sulfur bichloride  
 ノ 塩化チオニル
- (z) Thionyl chloride  
 オ エチルジエタノールアミン
- (aa) Ethyl diethanol amine  
 ク メチルジエタノールアミン
- (bb) Methyl diethanol amine  
 ヤ トリエタノールアミン
- (cc) Triethanolamine

2 輸出令別表第一の三の項（二）の経済産業省令で定める仕様のもは、次のいずれかに該当するものとする。

(2) Goods with specifications prescribed by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 3 (ii) of the appended table 1 of the Export Order shall fall under any of the following.

一 反応器であつて、容量が〇・一立方メートル超二〇立方メートル未満のものうち、内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの

(i) Among reactor vessels or reactors having a capacity exceeding 0.1 cubic meters and less than 20 cubic meters of which all portions that come into contact with the contents, those composed of, lined with or coated with materials falling under any of the following

イ ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の四〇パーセントを超える合金

(a) Nickel or alloys with a nickel content exceeding 40 % of the total weight

ロ ニッケルの含有量が全重量の二五パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の二〇パーセントを超える合金

(b) Alloys with a nickel content exceeding 25 % of the total weight and a chrome content exceeding 20 % of the total weight

ハ ふっ素樹脂

(c) Fluorine resin

ニ ガラス

(d) Glass

ホ タンタル又はタンタル合金

(e) Tantalum or tantalum alloys

ヘ チタン又はチタン合金

(f) Titanium or titanium alloys

ト ジルコニウム又はジルコニウム合金

(g) Zirconium or zirconium alloys

チ ニオブ又はニオブ合金

(h) Niobium or niobium alloys

二 貯蔵容器であつて、容量が〇・一立方メートルを超えるものうち、内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの

(ii) Among storage tanks, containers or receivers having a capacity exceeding 0.1 cubic meters, those all portions that come into contact with the contents of which are composed of, lined with or coated with materials falling under any of the following

イ ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の四〇パーセントを超える合金

(a) Nickel or alloys with a nickel content exceeding 40 % of the total weight

ロ ニッケルの含有量が全重量の二五パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の二〇パーセントを超える合金

(b) Alloys with a nickel content exceeding 25 % of the total weight and chrome content exceeding 20 % of the total weight

ハ ふっ素樹脂

(c) Fluorine resin

ニ ガラス

(d) Glass

ホ タンタル又はタンタル合金

(e) Tantalum or tantalum alloys

ヘ チタン又はチタン合金

(f) Titanium or titanium alloys

ト ジルコニウム又はジルコニウム合金

(g) Zirconium or zirconium alloys

チ ニオブ又はニオブ合金

(h) Niobium or niobium alloys

三 熱交換器又は凝縮器であつて、伝熱面積が〇・一五平方メートル超二〇平方メートル未満のものうち、内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの

(iii) Among heat exchangers or condensers having a heat transfer area exceeding 0.15 square meters and less than 20 square meters, those all portions that come into contact with the contents of which are composed of, lined with or coated with materials falling under any of the following

イ ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の四〇パーセントを超える合金

(a) Nickel or alloys with a nickel content exceeding 40 % of the total weight

ロ ニッケルの含有量が全重量の二五パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の二〇パーセントを超える合金

(b) Alloys with a nickel content exceeding 25 % of the total weight and chrome content exceeding 20 % of the total weight

ハ ふっ素樹脂

(c) Fluorine resin

ニ ガラス

(d) Glass

ホ 黒鉛又はカーボングラファイト

(e) Graphite or carbon graphite

ヘ タンタル又はタンタル合金

(f) Tantalum or tantalum alloys

ト チタン又はチタン合金

(g) Titanium or titanium alloys

チ ジルコニウム又はジルコニウム合金

(h) Zirconium or zirconium alloys

リ 炭化けい素

(i) Silicon carbide



ヌ 炭化チタン

(j) Titanium carbide

ル ニオブ又はニオブ合金

(k) Niobium or niobium alloys

三の二 前号に掲げるものの部分品であって、次のいずれかに該当するもの

(iii)-2 Components of those listed in the preceding item and that fall under any of the following

イ チューブ

(a) Tubes

ロ プレート

(b) Plates

ハ コイル

(c) Coils

ニ ブロック

(d) Blocks

四 蒸留塔又は吸収塔であって、塔の断面積が〇・〇〇七八五平方メートルを超えるもののうち、内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの

(iv) Among distillation or absorption columns with a cross section area exceeding 0.00785 square meters, those all parts that come into contact with the contents of which are composed of, lined with or coated with materials falling under any of the following

イ ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の四〇パーセントを超える合金

(a) Nickel or alloys with a nickel content exceeding 40 % of the total weight

ロ ニッケルの含有量が全重量の二五パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の二〇パーセントを超える合金

(b) Alloys with a nickel content exceeding 25 % of the total weight and chrome content exceeding 20 % of the total weight

ハ ふっ素樹脂

(c) Fluorine resin

ニ ガラス

(d) Glass

ホ 黒鉛又はカーボングラファイト

(e) Graphite or carbon graphite

ヘ タンタル又はタンタル合金

(f) Tantalum or tantalum alloys

ト チタン又はチタン合金

(g) Titanium or titanium alloys

チ ジルコニウム又はジルコニウム合金

(h) Zirconium or zirconium alloys

リ ニオブ又はニオブ合金

(i) Niobium or niobium alloys

四の二 前号に掲げるものの部分品であって、次のいずれかに該当するもの

(iv)-2 Components of those listed in the preceding item and that fall under any of the following

イ 液体分配器

(a) Liquid dispensers

ロ 蒸気分配器

(b) Vapor dispensers

ハ 液体収集器

(c) Liquid collectors

五 充てん用の機械であって、遠隔操作が可能であり、かつ、内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの

(v) Filling equipment capable of remote operation all portions that come into contact with the contents of which are composed of, lined with or coated with materials falling under any of the following

イ ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の四〇パーセントを超える合金

(a) Nickel or alloys with a nickel content exceeding 40 % of the total weight

ロ ニッケルの含有量が全重量の二五パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の二〇パーセントを超える合金

(b) Alloys with a nickel content exceeding 25 % of the total weight and a chrome content exceeding 20 % of the total weight

六 かくはん機であって、第一号に該当するものに用いられるもののうち、内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの

(vi) Among agitators used for those falling under item (i), those all portions that come into contact with the contents of which are composed of, lined with or coated with materials falling under any of the following

イ ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の四〇パーセントを超える合金

(a) Nickel or alloys with a nickel content exceeding 40 % of the total weight

ロ ニッケルの含有量が全重量の二五パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の二〇パーセントを超える合金

(b) Alloys with a nickel content exceeding 25 % of the total weight and chrome content exceeding 20 % of the total weight

ハ ふっ素樹脂

(c) Fluorine resin

ニ ガラス

(d) Glass

ホ タンタル又はタンタル合金

(e) Tantalum or tantalum alloys

ヘ チタン又はチタン合金

(f) Titanium or titanium alloys

ト ジルコニウム又はジルコニウム合金

(g) Zirconium or zirconium alloys

チ ニオブ又はニオブ合金

(h) Niobium or niobium alloys

六の二 前号に掲げるものの部分品であって、次のいずれかに該当するもの

(vi)-2 Components of those listed in the preceding item that fall under any of the following

イ インペラー

(a) Impellers

ロ ブレード

(b) Blades

ハ シャフト

(c) Shafts

七 呼び径が一〇A超の弁であって、内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの

(vii) Valves nominal diameter of which is exceeding 10 A (i.e. 10mm) and all portions that come into contact with the contents of which are composed of, lined with or coated with materials falling under any of the following

イ ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の四〇パーセントを超える合金

(a) Nickel or alloys with a nickel content exceeding 40 % of the total weight

ロ ニッケルの含有量が全重量の二五パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の二〇パーセントを超える合金

(b) Alloys with a nickel content exceeding 25 % of the total weight and a chrome content exceeding 20 % of the total weight

ハ ふっ素樹脂

(c) Fluorine resin

ニ ガラス

(d) Glass

ホ タンタル又はタンタル合金

(e) Tantalum or tantalum alloys

ヘ チタン又はチタン合金

(f) Titanium or titanium alloys

ト ジルコニウム又はジルコニウム合金

(g) Zirconium or zirconium alloys

チ ニオブ又はニオブ合金

(h) Niobium or niobium alloys

七の二 前号に掲げるものの部分品であって、次のいずれかに該当するもの

(vii)-2 Components of those listed in the preceding item that fall under any of the following

イ ケーシング

(a) Casings

ロ ケーシングライナー

(b) Casing liners

八 内容物の漏れを検知する装置を組み込んだ多重管であって、内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの

(viii) Multi-walled piping provided with equipment for detecting content leaks all portions that come into contact with the contents of which are composed of, lined with or coated with materials falling under any of the following

イ ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の四〇パーセントを超える合金

(a) Nickel or alloys with a nickel content exceeding 40 % of the total weight

ロ ニッケルの含有量が全重量の二五パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の二〇パーセントを超える合金

(b) Alloys with a nickel content exceeding 25 % of the total weight and chrome content exceeding 20 % of the total weight

ハ ふっ素樹脂

(c) Fluorine resin

ニ ガラス

(d) Glass

ホ 黒鉛又はカーボングラファイト

(e) Graphite or carbon graphite

ヘ タンタル又はタンタル合金

(f) Tantalum or tantalum alloys

ト チタン又はチタン合金

(g) Titanium or titanium alloys

チ ジルコニウム又はジルコニウム合金

(h) Zirconium or zirconium alloys

リ ニオブ又はニオブ合金

(i) Niobium or niobium alloys

九 二重以上のシールで軸封をしたポンプ若しくはシールレスポンプであって最高規定吐出し量が一時間につき〇・六立方メートルを超えるもの又は真空ポンプであって最高規定吐出し量が一時間につき五立方メートルを超えるもののうち、内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの

(ix) Among pumps axes of which are sealed by 2 or more layers or seal-less pumps the maximum specified discharge volume of which exceeds 0.6 cubic meters per hour, or vacuum pumps the maximum specified discharge volume of which exceeds 5 cubic meters per hour, those in which all portions that come into contact with the contents of which are composed of, lined with, or coated with materials falling under any of the following

イ ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の四〇パーセントを超える合金

(a) Nickel or alloys with a nickel content exceeding 40 % of the total weight  
ロ ニッケルの含有量が全重量の二五パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の二〇パーセントを超える合金

(b) Alloys with a nickel content exceeding 25 % of the total weight and a chrome content exceeding 20 % of the total weight

ハ ふっ素樹脂

(c) Fluorine resin

ニ ガラス

(d) Glass

ホ 黒鉛又はカーボングラファイト

(e) Graphite or carbon graphite

ヘ タンタル又はタンタル合金

(f) Tantalum or tantalum alloys

ト チタン又はチタン合金

(g) Titanium or titanium alloys

チ ジルコニウム又はジルコニウム合金

(h) Zirconium or zirconium alloys

リ セラミック

(i) Ceramic

ヌ フェロシリコン

(j) Ferrosilicon

ル ニオブ又はニオブ合金

(k) Niobium or niobium alloys

九の二 前号に掲げるものの部分品であって、次のいずれかに該当するもの

(ix)-2 Components of pumps listed in the preceding item and that fall under any of the following

イ ケーシング

(a) Casings

ロ ケーシングライナー

(b) Casing liners

ハ インペラー

(c) Impellers

ニ ロータ

(d) Rotors

ホ ジェットポンプノズル

(e) Jet pump nozzles

十 焼却装置であって、使用中における燃焼室の平均温度が一、〇〇〇度を超えるもののうち、焼却する物質を供給する部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、又は被覆されたもの

(x) Among incinerators average temperature of incineration chamber during use of which exceeds 1,000 degrees centigrade, portions for supplying the

substance to be incinerated of which are composed of or coated with materials falling under any of the following

イ ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の四〇パーセントを超える合金

(a) Nickel or alloys with a nickel content exceeding 40 % of the total weight

ロ ニッケルの含有量が全重量の二五パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の二〇パーセントを超える合金

(b) Alloys with a nickel content exceeding 25 % of the total weight and a chrome content exceeding 20 % of the total weight

ハ セラミック

(c) Ceramic

十一 空気中の物質を検知する装置又は検出器であつて、次のいずれかに該当するもの

(xi) Gas monitoring systems or dedicated detectors that fall under any of the following

イ 前項に掲げるものについて空気中における濃度が一立方メートル当たり〇・三ミリグラム未満であっても検知することができるものであり、かつ、連続して使用することができるもの

(a) Systems capable of detecting those listed in the preceding paragraph even when the concentration in the air is less than 0.3 milligrams per cubic meter and capable of continuous use

ロ アンチコリンエステラーゼ作用を有する化合物を検知することができるもの

(b) Systems capable of detecting compounds having an anticholinesterase effect

第二条の二 輸出令別表第一の三の二の項（一）の経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

Article 2-2 (1) Goods specified by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 3-2 (i) of the appended table 1 of the Export Order shall fall under any of the following.

一 ウイルス（ワクチンを除く。）であつて、アフリカ馬疫ウイルス、アフリカ豚コレラウイルス、エボラウイルス、黄熱ウイルス、オーエスキー病ウイルス、オムスク出血熱ウイルス、オロポーチウイルス、キャサヌール森林病ウイルス、牛疫ウイルス、狂犬病ウイルス、クリミアーコンゴ出血熱ウイルス、口蹄疫ウイルス、サル痘ウイルス、小反芻獣疫ウイルス、水胞性口炎ウイルス、西部ウマ脳炎ウイルス、セントルイス脳炎ウイルス、ダニ媒介性脳炎ウイルス、チクングニヤウイルス、跳躍病ウイルス、テッシェン病ウイルス、デング熱ウイルス、痘瘡ウイルス、東部ウマ脳炎ウイルス、トリインフルエンザウイルス（H五又はH七のH抗原を有するものに限る。）、豚コレラウイルス、ニパウイルス、日本脳炎ウイルス、ニューカッスル病ウイルス、肺及び腎症候性出血熱ウイルス、ハンターウイルス、ブタエンテロウイルス九型、フニンウイルス、ブルータングウイルス、ベネズエラウマ脳炎ウイルス、ヘンドラウイルス、ポテト・アンデアン・ラテント・チモウイルス、ポ

テト・スピンドル・チュバー・ウィロイド、ホワイトポックスウイルス、ポワッサンウイルス、マチュポウイルス、マールブルグウイルス、マレー溪谷脳炎ウイルス、南アメリカ出血熱、ヤギ痘ウイルス、羊痘ウイルス、ラッサ熱ウイルス、ランピーズスキン病ウイルス、リフトバレー熱ウイルス、リンパ球性脈絡髄膜炎ウイルス又はロシオウイルス

- (i) Viruses (excluding vaccines): the African horse sickness virus, the African swine fever virus, the Ebola virus, the yellow fever virus, Aujeszky's disease virus, the Omsk hemorrhagic fever virus, the Oropouche virus, the Kyasanur Forest disease virus, the cattle plague virus, the rabies virus, the Crimean-Congo hemorrhagic fever virus, the foot-and-mouth disease virus, the monkeypox virus, the peste des petits ruminants virus, the vesicular stomatitis virus, the western equine encephalitis virus, the Saint Louis encephalitis virus, the tick-borne encephalitis virus, the Chikungunya virus, the louping ill virus, the Teschen disease virus, the dengue fever virus, the smallpox virus, the eastern equine encephalitis virus, the avian influenza virus (limited to those having the H5 or H7 H antigen), the swine fever virus, the Nipah virus, the Japanese encephalitis virus, the Newcastle disease virus, the hemorrhagic fever virus with pulmonary and renal syndromes, the Hantaan virus, porcine enterovirus type 9, the Junin virus, the blue tongue virus, the Venezuelan equine encephalitis virus, the Hendra virus, the potato Andean latent tymovirus, the potato spindle tuber viroid, the white pox virus, the Powassan virus, the Machupo virus, the Marburg virus, the Murray Valley encephalitis virus, the South American hemorrhagic fever, the goat pox virus, the sheep pox virus, the Lassa fever virus, the lumpy skin disease virus, the Rift Valley fever virus, the lymphocytic choriomeningitis virus, or the Rocio virus

二 細菌（ワクチンを除く。）であって、ウシ流産菌、オウム病クラミジア、ガス壊疽菌、Q熱リケッチア、牛肺疫菌、コレラ菌、塹壕熱リケッチア、志賀赤痢菌、炭疽菌、チフス菌、腸管出血性大腸菌血清型O一五七、発疹チフスリケッチア、鼻疽菌、ブタ流産菌、ペスト菌、ボツリヌス菌、マルタ熱菌、野兔病菌、類鼻疽菌又はロッキー山紅斑熱リケッチア

- (ii) Bacteria (excluding vaccines): *Brucella abortus*, *Chlamydia psittaci*, the gas bacillus, *Coxiella burnetii*, *Mycoplasma mycoides*, the cholera bacillus, trench fever rickettsia, *Shigella dysenteriae*, *Bacillus anthracis*, the typhoid bacillus, enterohemorrhagic *Escherichia coli* serotype O157, *Rickettsia prowazekii*, *Actinobacillus mallei*, *Brucella suis*, *Bacillus pestis*, *Bacillus botulinus*, *Brucella melitensis*, *Bacillus tularensis*, *Pseudomonas pseudomallei*, or *Rickettsia rickettsii*

三 毒素（免疫毒素を除く。）であって、アフラトキシン、アブリン、ウェルシュ菌毒素、HT-2トキシン、黄色ブドウ球菌毒素、コノトキシン、コレラ毒素、赤痢菌毒素、デアセトキシシルペノール毒素、T-2トキシン、テトロドトキシン、

ビスカムアルBUMレクチン、ベロ毒素及び志賀毒素様リボゾーム不活化蛋白質、ボツリヌス毒素、ボルケンシン、マイクロシスチン又はモデシン

(iii) Toxins (excluding immunotoxins): aflatoxin, abrin, clostridium welchii toxin, HT-2 toxin, staphylococcal enterotoxin, conotoxin, cholera toxin, Shigella dysenteriae toxin, diacetoxyscirpenol toxin, T-2 toxin, tetrodotxin, Viscum album lectin, verotoxin or Shiga toxin-like ribosome inactive protein, botulin toxin, Volkensin, microcystin, or modeccin

四 前号又は前条第一項第二号イ若しくはロに該当するもののサブユニット

(iv) Subunits of those falling under the preceding item or the preceding Article, paragraph (1), item (ii), (a) or (b)

五 細菌又は菌類であつて、クラビバクター・ミシガネンシス亜種セペドニカス、コクシジオイデス・イミチス、コクシジオイデス・ポサダシ、コクリオボールス・ミヤベアヌス、コレトトリクム・コフェアヌム・バラエティー・ビルランス、ザントモナス・アルビリネアンス、ザントモナス・オリゼ・パソバー・オリゼ、ザントモナス・キャンペストリス・パソバー・シトリ、ピリキュラリア・オリゼ、ピリキュラリア・グリセア、プクシニア・グラミニス、プクシニア・ストライフオルミス、マイクロシクルス・ウレイ又はラルストニア・ソラナセアルム・レース二及び三

(v) Bacteria or fungi: Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, Coccidioides immitis, Coccidioides posadasii, Cochliobolus miyabeanus, Colletotrichum coffeanum var. virulans, Xanthomonas albilineans, Xanthomonas oryzae pv. oryzae, Xanthomonas campestris pv. citri, Pyricularia oryzae, Pyricularia grisea, Puccinia graminis, Puccinia striiformis, Microcyclus ulei, or Ralstonia solanacearum race 2 or 3

六 第一号、第二号若しくは前号に該当するものの核酸の塩基配列のうち病原性を発現させるもの又は第三号若しくは前条第一項第二号イ若しくはロ若しくは第四号に該当するものを産生させる核酸の塩基配列を有する遺伝子（染色体、ゲノム、プラスミド、トランスポゾン及びベクターを含む。）

(vi) Genes (including chromosomes, genomes, plasmids, transposons, and vectors) having a base sequence of nucleic acids falling under item (i), item (ii), or the preceding item, wherein that base sequence of nucleic acids causes the expression of pathogenicity or the production of those falling under item (iii); or the previous Article, paragraph (1), item (ii), (a) or (b), or item (iv)

七 第一号、第二号若しくは第五号に該当するものの核酸の塩基配列のうち病原性を発現させるもの又は第三号若しくは前条第一項第二号イ若しくはロ若しくは第四号に該当するものを産出させる核酸の塩基配列を有するように遺伝子を改変した生物（微生物を含む。）

(vii) Organisms (including microorganisms) the gene of which is altered such render a base sequence of nucleic acids falling under item (i), item (ii), or item (v), wherein that base sequence of nucleic acids causes the expression of pathogenicity or the production of substances falling under item (iii); or the previous Article, paragraph (1), item (ii), (a) or (b), or item (iv)



2 輸出令別表第一の三の二の項（二）の経済産業省令で定める仕様のもは、次のいずれかに該当するものとする。

(2) Goods with specifications prescribed by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 3-2 (ii) of the appended table 1 of the Export Order shall fall under any of the following.

一 物理的封じ込めに用いられる装置であって、次のいずれかに該当するもの

(i) Physical containment facilities falling under any of the following

イ 物理的封じ込めのレベルがP三又はP四である施設用の装置

(a) Equipment for facilities with physical containment level of P3 or P4

ロ クラスー I I I 安全キャビネットの有する物理的封じ込めの機能と同等の機能を有するアイソレータ

(b) Isolators having physical containment functions equivalent to those of class III safety cabinets

二 密閉式の発酵槽であって、容量が二〇リットル以上のもの

(ii) Hermetically sealed fermenters, the capacity of which is 20 liters or more

三 連続式の遠心分離機であって、次のイからニまでのすべてに該当するもの

(iii) Continuous centrifuge separators falling under all of the following (a) through (d)

イ 流量が一時間につき一〇〇リットルを超えるもの

(a) Separators with a flow volume exceeding 100 liters per hour

ロ 研磨したステンレス鋼又はチタンで構成されたもの

(b) Separators comprised of polished stainless steel or titanium

ハ メカニカルシールで軸封をしているもの

(c) Separators having an axle sealed with a mechanical seal

ニ 定置し、かつ、閉じた状態で蒸気により内部の滅菌をすることができるもの

(d) Separators capable of internal sterilization using vapor when fixed and in a closed state

四 クロスフローろ過用の装置であって、次のイ及びロに該当するもの（ただし、逆浸透膜を用いたものを除く。）

(iv) Cross (tangential) flow filtration equipment falling under the following (a) or (b) (excluding those using a reverse penetration membrane)

イ 有効ろ過面積の合計が一平方メートル以上のもの

(a) Equipment with a total effective filtering area of 1 square meter or more

ロ 定置した状態で内部の滅菌又は殺菌をすることができるもの

(b) Equipment capable of internal sterilization or disinfection in a fixed state

四の二 前号に掲げるものに使用するよう設計した部分品であって、有効ろ過面積が〇・二平方メートル以上のもの

(iv)-2 Components designed for use for those listed in the preceding item with an effective filtering area of 0.2 square meters or more

五 凍結乾燥器であって、次のイ及びロに該当するもの

(v) Freeze-drying equipment falling under the following (a) and (b)

イ 二四時間につき一〇キログラム以上一、〇〇〇キログラム未満の氷を作る能力を有するもの

(a) Equipment having the capacity to create 10 kilogram or more and less than 1,000 kilograms of ice in a 24-hour period

ロ 蒸気により内部の滅菌をすることができるもの

(b) Equipment capable of internal sterilization using vapor

六 物理的封じ込め施設において用いられる防護のための装置であって、エアライン方式の換気用の装置を有する全身の若しくは半身の衣服又はフードであるもののうち、その内部を陽圧に維持することができるもの

(vi) Among whole or half body clothing or hoods that possess protective equipment used in physical containment and airline ventilation use equipment, those capable of maintaining a positive internal pressure

七 粒子状物質の吸入の試験用の装置であって、吸入室の容積が一立方メートル以上のもの

(vii) Aerosol inhalation chambers with the capacity of 1 square meter or more

八 噴霧器若しくは煙霧機又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの

(viii) Spraying or fogging systems or components thereof, that fall under any of the following

イ 航空機、飛行船、気球又は無人航空機に搭載するように設計した噴霧器又は煙霧機であって、初期粒径が体積メディアン径で五〇ミクロン未満の飛沫を液体搭載装置から二リットル毎分超の割合で散布できるもの

(a) Spraying or fogging systems designed to be mounted in aircraft, airship, balloon, or unmanned aerial vehicles capable of dispersing droplets initial particles of which have a median cubic diameter less than 50 microns from an on-board liquid device at a rate exceeding 2 liters per minute

ロ 航空機、飛行船、気球又は無人航空機に搭載するように設計したエアゾール発生装置のスプレーブーム又はノズルであって、初期粒径が体積メディアン径で五〇ミクロン未満の飛沫を液体搭載装置から二リットル毎分超の割合で散布できるもの

(b) A spray boom or nozzle for an aerosol generators designed to be mounted in aircraft, airship, balloon, or unmanned aerial vehicles capable of dispersing droplets, the initial particles of which have a median cubic diameter less than 50 microns from an on-board liquid spraying devices at a rate exceeding 2 liters per minute

ハ 初期粒径が体積メディアン径で五〇ミクロン未満の飛沫を液体搭載装置から二リットル毎分超の割合で散布できる装置に使用するように設計したエアゾール発生装置

(c) Aerosol generators designed to be used in a devices capable of dispersing droplets initial particles of which have a median cubic diameter less than 50 microns from an on-board liquid spraying device at a rate exceeding 2

liters per minute

第三条 輸出令別表第一の四の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

Article 3 Goods with specifications prescribed by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 4 of the appended table 1 of the Export Order shall fall under any of the following.

一 ロケット又は五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットの製造用の装置若しくは工具（型を含む。以下この条において同じ。）、試験装置若しくはこれらの部分品

(i) Rockets or equipment or tools (including molds; hereinafter the same shall apply in this Article) for the manufacture of rockets capable of transporting payloads weighing 500 kilograms or more for 300 kilometers or more, test equipment, or components thereof

一の二 ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機

(i)-2 Unmanned aerial vehicles capable of transporting payloads for 300 kilometers or more

一の三 エアゾールを噴霧できるように設計した無人航空機であって、燃料の他に粒子又は液体状で二〇リットルを超えるペイロードを運搬することができるものうち、次のいずれかに該当するもの（前号に該当するもの又は娯楽若しくはスポーツの用に供する模型航空機を除く。）

(i)-3 Among unmanned aerial vehicles designed to be capable of atomizing aerosol and capable of transporting payloads exceeding 20 liters in a particulate or liquid form in addition to fuel, and falling under any of the following (excluding those falling under the preceding item and model aircraft used for entertainment or sports)

イ 自律的な飛行制御及び航行能力を有するもの

(a) Vehicles having an autonomous flight control or navigation capability

ロ 視認できる範囲を超えて人が飛行制御できる機能を有するもの

(b) Vehicles having a function enabling flight control by a person exceeding the visible range

二 次のいずれかに該当する貨物又はその製造用の装置若しくは工具、試験装置若しくはこれらの部分品

(ii) Goods falling under any of the following or equipment or tools for the manufacture thereof, or test equipment, or components thereof

イ ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットに使用することができる貨物であって、次のいずれかに該当するもの

(a) Goods usable in rockets capable of transporting payloads for 300 kilometers or more, and falling under any of the following

(一) 多段ロケットの各段

1. Individual stages of multiple-stage rockets

- (二) 固体ロケット推進装置又は液体ロケット推進装置であって、全力積が八四一、〇〇〇ニュートン秒以上のもの
2. Solid rocket propulsion units or liquid rocket propulsion unit with the total impulse of 841,000 Newton-seconds or more
- ロ 五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができる貨物であって、次のいずれかに該当するもの
- (b) Goods capable of use in rockets or unmanned aerial vehicles capable of transporting payloads weighing 500 kilograms or more for 300 kilometers or more, falling under any of the following
- (一) 再突入機
1. Re-entry vehicles
- (二) 再突入機の熱遮へい体（セラミック又はアブレーション材料を用いたものに限る。）又はその部分品
2. Thermal shields (limited to those using ceramic or abrasion materials) for re-entry vehicles or components thereof
- (三) 再突入機のヒートシンク又はその部分品
3. Heat sinks for re-entry vehicles and components thereof
- (四) 再突入機に使用するように設計した電子機器
4. Electronics parts designed for use for re-entry vehicles
- (五) 誘導装置であって、飛行距離に対する平均誤差半径の比率が三・三三パーセント以下のもの
5. Guidance equipment with a ratio of average error radius to flight distance of 3.33 % or less
- (六) 推力の方向を制御する装置
6. Thrust vector controllers
- 三 推進装置若しくはその部分品、モータケースのライニング若しくは断熱材であって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの製造用の装置若しくは工具、試験装置若しくはこれらの部分品
- (iii) Propulsion units or components thereof, motor case linings, or insulation materials falling under any of the following, or equipment or tools for the manufacture thereof, or test equipment, or components thereof
- イ ターボジェットエンジン又はターボファンエンジンであって、次の（一）及び（二）に該当するもの
- (a) Turbojet engines or turbo fan engines falling under the following 1 and 2
- (一) 機体に搭載されていない状態における最大推力が四〇〇ニュートンを超えるもの（機体に搭載されていない状態における最大推力が八、八九〇ニュートンを超えるものであって、本邦の政府機関が民間航空機に使用することを認定したものを除く。）
1. Engines maximum thrust of which is 400 newtons or more when not mounted in an airframe (excluding those maximum thrust of which is

8,890 newtons or more when not mounted in an airframe and the use of which in private aircraft has been authorized by Japanese governmental institution)

(二) 海面上における標準大気状態での最大連続推力の燃料消費量が一時間につき推力一ニュートン当たり〇・一五キログラム以下のもの

2. Engines fuel consumption of which at maximum continuous thrust is 0.15 kilograms per thrustnewton per hour or less in standard atmospheric conditions above the sea

ロ ラムジェットエンジン、スクラムジェットエンジン、パルスジェットエンジン若しくは複合サイクルエンジン（五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。）又はこれらの部分品

(b) Ramjet engines, scramjet engines, pulse jet engines, or combined cycle engines (limited to those usable in rockets or unmanned aerial vehicles capable of transporting payloads weighing 500 kilograms or more for 300 kilometers or more) or components thereof

ハ 固体ロケット用のモータケースであって、五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるもの

(c) Motor cases for solid rockets usable in rockets or unmanned aerial vehicles capable of transporting payloads weighing 500 kilograms or more for 300 kilometers or more

ニ 固体ロケット用のモータケースのライニング（推進薬とモータケース又は断熱材を結合することができるものに限る。）であって、五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機に使用することができるもの又は五〇〇キログラム未満のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機に使用するように設計したもの

(d) Motor case linings for solid rockets (limited to those in which the propellant and motor case or insulation can be combined) usable in rockets or unmanned aerial vehicles capable of transporting payloads weighing 500 kilograms or more for 300 kilometers or more or designed for use in rockets or unmanned aircraft capable of transporting payloads weighing less than 500 kilograms for 300 kilometers or more

ホ 固体ロケット用のモータケースの断熱材であって、五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機に使用することができるもの又は五〇〇キログラム未満のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機に使用するように設計したもの

(e) Motor case insulation for solid rockets, usable in rockets or unmanned aerial vehicles capable of transporting payloads weighing 500 kilograms or

more for 300 kilometers or more or designed for use in rockets or unmanned aircraft capable of transporting payloads weighing less than 500 kilograms for 300 kilometers or more

ヘ 固体ロケット用のモータケースのノズルであって、五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるもの

(f) Motor case nozzles for solid rockets usable in rockets or unmanned aerial vehicles capable of transporting payloads weighing 500 kilograms or more for 300 kilometers or more

ト 液体状又はスラリー状の推進薬の制御装置であって、周波数範囲が二〇ヘルツ以上二、〇〇〇ヘルツ以下で、かつ、加速度の実効値が九八メートル毎秒毎秒を超える振動に耐えることができるように設計したもの（五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。）又はその部分品（サーボ弁及びポンプを除く。）

(g) Control equipment for propellants in liquid or slurry states, the frequency range of which is 20 hertz or more and 2,000 hertz or less and designed to be capable of withstanding vibrations with effective acceleration rate exceeding 98 meters per second squared (limited to control equipment which can be used in rockets or unmanned aerial vehicles capable of transporting payloads weighing 500 kilograms or more for 300 kilometers or more) and components thereof (excluding servo valves and pumps)

チ ハイブリッドロケット推進装置（ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。）又はその部分品

(h) Hybrid rockets propulsion units (limited to those usable in rockets or unmanned aerial vehicles capable of transporting payloads for 300 kilometers or more) or components thereof

リ 液体推進薬用のタンクであって、次のいずれかに該当するものに使用するよう設計したもの

(i) Tanks for liquid propellants designed for use in those falling under any of the following

(一) 第七号に該当する推進薬又はその原料となる物質

1. Propellants falling under item (vii) or raw materials thereof

(二) 液体推進薬（（一）に該当するものを除く。）であって、五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットに使用するもの

2. Liquid propellants (excluding those falling under 1.) used in rockets capable of transporting payloads weighing 500 kilograms or more for 300 kilometers or more

四 多段ロケットの切離し装置又は段間継手（五〇〇キログラム以上のペイロードを

三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットに使用することができるものに限る。) 又はこれらの製造用の装置若しくは工具、試験装置若しくはこれらの部分品

(iv) Separation mechanisms or staging mechanisms for multiple-stage rockets (limited to those usable for a rocket capable of transporting payloads weighing 500 kilograms or more for 300 kilometers or more), or equipment or tools for the manufacture thereof, or test equipment, or components thereof

五 しごきスピニング加工機であって、数値制御装置又は電子計算機によって制御することができるもののうち、輪郭制御をすることができる軸数が三以上のもの又はその部分品

(v) Flow-forming machines that can be controlled by numerically-controlled coordinate measurement equipment and computers, with 3 or more axes capable of contouring control, or components thereof

六 サーボ弁又は推進薬の制御装置に使用することができるポンプであって、次のイ及びロに該当するもののうち、ハ又はニのいずれかに該当するもの

(vi) Among pumps usable for servo valves or controllers for propellants and that fall under any of the following (a) and (b), those falling under (c) or (d)

イ 液体状又はスラリー状の推進薬の制御装置に使用するように設計したもの

(a) Pumps designed for use in controllers for propellants in liquid or slurry states

ロ 周波数範囲が二〇ヘルツ以上二、〇〇〇ヘルツ以下で、かつ、加速度の実効値が九八メートル毎秒毎秒を超える振動に耐えることができるように設計したもの

(b) Pumps frequency range of which is 20 hertz or more and 2,000 hertz or less and designed to be able to withstand vibrations with effective acceleration rate exceeding 98 meters per second squared

ハ 絶対圧力が七、〇〇〇キロパスカル以上の状態において一分につき〇・〇二四立方メートル以上流すことができるように設計したサーボ弁であって、アクチュエータの応答時間が一〇〇ミリ秒未満のもの

(c) Pumps designed to allow a flow of 0.024 cubic meters per minute or more in a state wherein the absolute pressure is 7,000 kilopascals or more and the actuator response time of which is less than 100 milliseconds

ニ ポンプであって、軸の回転数が一分につき八、〇〇〇回転以上のもの又は吐出し圧力が七、〇〇〇キロパスカル以上のもの

(d) Pumps with the number of rotation of axles of 8,000 rotations per minute or more or discharge pressure of 7,000 kilopascals or more

六の二 推進薬の制御装置に使用できるポンプ用に設計されたラジアル玉軸受であって、日本工業規格B一五一四号(転がり軸受の精度)で定める精度が二級以上のもののうち、次のイからハまでのすべてに該当するもの

(vi)-2 Among radial ball bearings designed for pumps usable for controllers for propellants precision of which is class 2 or more as specified in Japanese Industrial Standards B1514 (rolling bearing precision), those falling under

all of the following (a) through (c)

イ 内輪内径が一ミリメートル以上五〇ミリメートル以下のもの

(a) Bearings with an inner wheel internal diameter of 12 millimeters or more and 50 millimeters or less

ロ 外輪外径が二五ミリメートル以上一〇〇ミリメートル以下のもの

(b) Bearings with an outer wheel external diameter of 25 millimeters or more and 100 millimeters or less

ハ 幅が一〇ミリメートル以上二十ミリメートル以下のもの

(c) Bearings with a width of 10 millimeters or more and 20 millimeters or less

七 推進薬又はその原料となる物質であって、次のいずれかに該当するもの

(vii) Propellants or raw material thereof falling under any of the following

イ 濃度が七〇パーセントを超えるヒドラジン

(a) Hydrazine with concentration exceeding 70 %

ロ ヒドラジンの誘導体

(b) A derivative of hydrazine

ハ 過塩素酸アンモニウム

(c) Ammonium perchlorate

ニ アンモニウムジニトラミド

(d) Ammonium dinitramide

ホ 粒子が球形で、その径が二〇〇マイクロメートル未満のアルミニウムの粉であって、重量比による純度が九七パーセント以上のもののうち、国際規格 I S O 二五九一（一九八八）又はこれと同等の規格で定める測定方法により測定した径が六三マイクロメートル未満のもの含有量が全重量の一〇パーセント以上のもの

(e) Among aluminum powder the particles of which are globular and with diameter thereof less than 200 micrometers and with a weight-based purity level of 97 % or more, those the content of those diameter of which is less than 63 micrometers as measured by measurement method specified in International Organization for Standardization ISO 2591:1988 or standards equivalent thereto is 10 % or more of the total weight

ヘ 重量比による純度が九七パーセント以上のジルコニウム（天然の比率でジルコニウムに含まれるハフニウムを含む。）、ベリリウム、マグネシウム又はこれらの合金であって、粒子の径が六〇マイクロメートル未満の粉末状のもの

(f) Zirconium (containing hafnium contained in the zirconium at a natural ratio), beryllium, magnesium, or alloys thereof with a weight-based purity level of 97 % and in a powder state or more particle diameter of which is 60 micrometers or less

ト 重量比による純度が八五パーセント以上のほう素又はその合金であって、粒子の径が六〇マイクロメートル未満の粉末状のもの

(g) Boron or alloy thereof with a weight-based purity level of 85 % or more by a yield-to-weight comparison and in a powder state particle diameter of



- which is 60 micrometers or less
- チ 過塩素酸塩、塩素酸塩又はクロム酸塩であつて、粉末状の金属又は燃料成分が混合されたもの
- (h) A perchlorate, a chlorate, or a chromate in which a powdered metal or fuel constituent is mixed
- リ カルボラン、デカボラン、ペンタボラン又はこれらの誘導体
- (i) Carborane, decaborane, or pentaborane, or a derivative thereof
- ヌ 液体酸化剤であつて、次のいずれかに該当するもの
- (j) A liquid oxidizer falling under any of the following
- (一) 三酸化二窒素
  1. Dinitrogen trioxide
  - (二) 二酸化窒素又は四酸化二窒素
  2. Nitrogen dioxide or dinitrogen tetraoxide
  - (三) 五酸化二窒素
  3. Dinitrogen pentoxide
  - (四) 窒素酸化物の混合物
  4. A mixture of nitrogen oxide
  - (五) 耐腐食性を有する赤煙硝酸
  5. Red fuming nitric acid having resistance to corrosion
  - (六) ふっ素及びその他のハロゲン、酸素又は窒素からなる化合物（気体の三ふっ化窒素を除く。）
  6. A compound made from fluorine or other halogens, oxygen, or nitrogen (excluding nitrogen trifluoride gas)
- ル 末端にカルボキシル基を有するポリブタジエン
- (k) Polybutadiene having a carboxyl group at its terminal
- ヲ 末端に水酸基を有するポリブタジエン
- (l) Polybutadiene having a hydroxyl group at its terminal
- ワ グリシジルアジドの重合体
- (m) A glycidylamide polymer
- カ ブタジエンとアクリル酸との重合体
- (n) A polymer of butadiene and acrylic acid
- ヨ ブタジエンとアクリロニトリルとアクリル酸との重合体
- (o) A polymer of butadiene, acrylonitrile, and acrylic acid
- タ 発熱量が一キログラム当たり四〇、〇〇〇、〇〇〇ジュール以上の推進薬
- (p) A propellant with heating value of 40,000,000 joules per kilogram or more
- レ トリス——（二—メチル）アジリジニルホスフィンオキシド
- (q) Tris-1-(2-methyl) aziridinyl phosphine oxide
- ソ テトラエチレンペンタミン、アクリロニトリル及びグリシドールの反応生成物
- (r) A reaction product of tetraethylenepentamine, acrylonitrile, and glycidol
- ツ テトラエチレンペンタミン及びアクリロニトリルの反応生成物
- (s) A reaction product of tetraethylenepentamine and acrylonitrile

ネ イソフタル、トリメシン、イソシアヌル又はトリメチルアジピンの骨格を有する多官能性アジリジンアミドであって、二メチルアジリジン基又は二エチルアジリジン基を有するもの

(t) A multi-functional aziridineamide having an isophthal-, trimesin-, isocyanur-, or trimethyladipin- skeleton having a 2-methylaziridine group or a 2-ethylaziridine group

ナ トリフェニルビスマス

(u) Triphenylbismuth

ラ フェロセン誘導体

(v) A ferrocene derivative

ム トリエチレングリコールジナイトレート

(w) Triethylene glycol dinitrate

ウ トリメチロールエタントリナイトレート

(x) Trimethylolethane trinitrate

キ 一・二・四ブタントリオールトリナイトレート

(y) 1,2,4-butanetrioltrinitrate

ノ ジエチレングリコールジナイトレート

(z) Diethylene glycol dinitrate

八 次のいずれかに該当する推進薬若しくはその原料となる物質の製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置又はこれらの部分品（次号から第十号の二までのいずれかに該当するものを除く。）

(viii) Equipment or tools for the production of propellants or raw materials thereof, or test equipment or components thereof (excluding those falling under any of the next item through item (x)-2)

イ 前号に該当する貨物

(a) Goods falling under the preceding item

ロ オクトーゲン又はヘキソーゲン

(b) Octogen or hexagen

ハ コンポジット推進薬

(c) A composite propellant

ニ 二ニトロジフェニルアミン又はN-メチル-P-ニトロアニリン

(d) 2-nitrodiphenylamine or N-methyl-P-nitroaniline

九 バッチ式の混合機（液体用のものを除く。）であって、〇以上一三・三二六キロパスカル以下の絶対圧力で混合することができるもののうち、混合容器内の温度を制御することができ、かつ、次のイ及びロに該当するもの又はその部分品

(ix) Among batch mixers (excluding those for liquids) usable at an absolute pressure of 0 kilopascal or more and 13.326 kilopascals or less, those capable of controlling the temperature inside the mixing container, and falling under the following (a) and (b) or components thereof

イ 全容量が一〇リットル以上のもの

(a) Mixers with total volume of 110 liters or more

- ロ 混合機の中心軸から離れた混和軸又は捏和軸を少なくとも一本有するもの
- (b) Mixers having at least one mixing axis or a kneading axis separated from the center axis thereof
- 九の二 連続式の混合機（液体用のものを除く。）であって、〇以上一三・三二六キロパスカル以下の絶対圧力で混合することができるもののうち、混合容器内の温度を制御することができ、かつ、次のいずれかに該当するもの又はその部分品
- (ix)-2 Among continuous mixers (excluding those for liquids) capable of mixing at an absolute pressure of 0 kilopascal or more and 13.326 kilopascals or less, those capable of controlling the temperature inside the mixing container, and falling under the following, or components thereof
- イ 二本以上の混和軸又は捏和軸を有するもの
- (a) Mixers having 2 or more mixing axles or kneading axles
- ロ 振動機能を備えた一本の回転軸を有し、かつ、混合容器内及び回転軸上に捏和のための突起を有するもの
- (b) Mixers having one rotating axle with a vibration function and having a projection for kneading in the mixing container and on the rotating axle
- 十 第七号若しくは第八号ロからニまでのいずれかに該当する推進薬若しくはその原料となる物質を粉砕することができるジェットミル又はその部分品
- (x) Jet mills capable of pulverizing propellants falling under any of item (vii) or item (viii), (b) through (d) or raw materials thereof or components thereof
- 十の二 第七号ホからトまでのいずれかに該当する金属の粉末（噴霧粉又は球形粉に限る。）の製造用の装置又はその部分品
- (x)-2 Equipment for the production of powder (limited to atomized powders or globular powders) of metals falling under any of item (vii), (e) through (g) or components thereof
- 十一 複合材料、繊維、プリプレグ又はプリフォーム（五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。）の製造用の装置であって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品若しくは附属品
- (xi) Equipment for the production of composites, fibers, preregs, or preforms (limited to those usable in rockets or unmanned aerial vehicles capable of transporting payloads weighing 500 kilograms or more for 300 kilometers or more) and that falls under any of the following or parts or accessories thereof
- イ フィラメントワインディング装置であって、繊維を位置決めし、包み及び巻く作業を行うもののうち、それらの作業を相関して制御することができる軸数が三以上のもの又はその制御装置
- (a) Among filament winding machines for positioning fibers and carrying out wrapping and winding operations, those with three or more axles capable of controlling those operations in a correlated manner or controllers thereof
- ロ 複合材料からなる航空機の機体又はロケットの構造体を製造するためのものであって、テープ又はシートを位置決めし、及びラミネートする作業を行うものの

- うち、それらの作業を相関して制御することができる軸数が二以上のもの
- (b) Among equipment for the production of airframes of an aircraft or the structure of rockets comprised of composites, and for positioning tape or sheets and carrying out lamination operations, those with 2 or more axles capable of controlling those operations in a correlated manner
- ハ 三次元的に織ることができる織機又はインターレーシングマシン
- (c) Weaving machines or interlacing machines capable of three-dimensional weaving
- ニ 繊維の製造用の装置であって、次のいずれかに該当するもの
- (d) Equipment for the production of fibers that falls under any of the following
- (一) 重合体繊維から他の繊維を製造する装置
1. Equipment for the production of other fibers from polymer fibers
- (二) 熱したフィラメント状の基材に元素又は化合物を蒸着させるための装置
2. Equipment for vapor depositing elements or compounds on substrates in a heated filament form
- (三) 耐火セラミックの湿式紡糸装置
3. Wet spinning apparatus for fire-resistant ceramics
- ホ 繊維の表面処理又はプリプレグ若しくはプリフォームの製造を行うように設計したもの
- (e) Equipment designed for surface treating of fibers or the production of prepreps or preforms
- 十二 ノズルであって、原料ガスの熱分解（一、三〇〇度以上二、九〇〇度以下の温度範囲において、かつ、一三〇パスカル以上二〇、〇〇〇パスカル以下の絶対圧力の範囲において行うものに限る。）により生成する物質を基材に定着させるためのもの
- (xii) Nozzles used in fixing substances generated from the thermal decomposition of gas onto substrates (limited to that carried out in the temperature range 1,300 degrees centigrade or more and 2,900 degrees centigrade or less and the absolute pressure range of 130 pascals or more and 20,000 pascals or less) to substrates
- 十三 ロケット推進装置のノズル若しくは再突入機の先端部の製造用の装置であって、次のいずれかに該当するもの又はその制御装置
- (xiii) Equipment for the production of nozzle of rocket propulsion systems or re-entry vehicle nose tips, and that falls under any of the following or process controls thereof
- イ 構造材料の炭素の密度を増加させるためのもの
- (a) Equipment for the densification of carbon of structural materials
- ロ 原料ガスの熱分解により生成する炭素を基材に定着させるためのもの
- (b) Equipment for fixing carbon generated from the thermal decomposition of gas onto substrates

十四 アイソスタチックプレスであって、次のイからハまでのすべてに該当するもの  
又はその制御装置

(xiv) Isostatic presses falling under all of the following (a) through (c) or controllers thereof

イ 最大圧力が六九メガパスカル以上のもの

(a) Isostatic presses with maximum pressure of 69 megapascals or more

ロ 中空室内の温度制御ができるもの（中空室内の温度が六〇〇度以上の場合に限る。）

(b) Isostatic presses capable of temperature control in hollow cavities

(limited to the case when the temperature of hollow cavities is 600 degrees centigrade or more)

ハ 中空室の内径が二五四ミリメートル以上のもの

(c) Isostatic presses, with an internal diameter of hollow cavities of 254 millimeters or more

十五 炭素及び炭素繊維を用いた複合材料の炭素の密度を増加させるために設計した炉であって、化学的気相成長用のもの又はその制御装置

(xv) Furnaces designed for the densification of carbon or carbon fibers for chemical vapor deposition or controllers thereof

十六 構造材料であって、次のいずれかに該当するもの

(xvi) Structural materials falling under any of the following

イ 比強度が七六、二〇〇メートルを超え、かつ、比弾性率が三、一八〇、〇〇〇メートルを超える繊維で補強した有機物若しくは金属をマトリックスとするものからなる複合材料（プリプレグであって、ガラス転移点が一四五度以下のものを除く。）又はその成型品（五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット、第二号イに該当する貨物（五〇〇キログラム以上のペイロードを運搬することができるロケットに使用することができるものに限る。）又は同号ロに該当する貨物に使用するように設計したものに限る。）

(a) Composites (excluding prepregs with glass transition points of 145 degrees centigrade or less) made from organic substances reinforced with fibers specific strength exceeding 76,200 meters and specific elastic modulus exceeding 3,180,000 meters or those with metal in the matrix phase, or molded products thereof (limited to rockets capable of transporting payloads weighing 500 kilograms or more for 300 kilometers or more, goods falling under item (ii) (limited to those usable for a rocket capable of transporting payloads weighing 500 kilograms or more), or those designed to be used in goods falling under item (ii))

ロ ロケット用に設計した炭素及び炭素繊維を用いた複合材料又はその成型品（五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。）

(b) Composites using carbon and carbon fibers designed for rocket use or

molded products thereof (limited to those usable in rockets or unmanned aerial vehicles capable of transporting payloads weighing 500 kilograms or more for 300 kilometers or more)

ハ 人造黒鉛であって、次のいずれかに該当するもの（ロケットのノズル又は再突入機の先端部に使用することができるものに限る。）

(c) Artificial graphite falling under any of the following (limited to artificial graphite usable for rocket nozzles or re-entry vehicles nose tips)

(一) 一五度の温度で測定したときのかさ密度が一立方センチメートル当たり一・七二グラム以上で、かつ、粒子の径が一〇〇マイクロメートル以下の人造黒鉛であって、次のいずれかに加工することができるもの

1. Artificial graphite, the bulk density of which measured at 15 degrees centigrade is 1.72 grams per cubic centimeter or more and the particle diameter of which is 100 micrometers or less and which is capable of being processed into any of the following

1 円筒であって、直径が一二〇ミリメートル以上で、かつ、長さが五〇ミリメートル以上のもの

i. Cylinders with a diameter of 120 millimeters or more and a length of 50 millimeters or more

2 管であって、内径が六五ミリメートル以上で、厚さが二五ミリメートル以上で、かつ、長さが五〇ミリメートル以上のもの

ii. Pipes with internal diameters of 65 millimeters or more, thicknesses of 25 millimeters or more, and lengths of 50 millimeters or more

3 塊であって、各辺の長さがそれぞれ一二〇ミリメートル以上、一二〇ミリメートル以上及び五〇ミリメートル以上の直方体を切り出すことができるもの

iii. Ingots from which a rectangular parallelepiped can be carved out, each of the dimensions of which is respectively 120 millimeters or more, 120 millimeters or more, and 50 millimeters or more

(二) 熱分解黒鉛（五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。）

2. Pyrolytic graphite (limited to that usable in rockets or unmanned aerial vehicles capable of transporting payloads weighing 500 kilograms or more for 300 kilometers or more)

(三) 繊維で強化した黒鉛（五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。）

3. Graphite strengthened with fibers (limited to that usable in rockets or unmanned aerial vehicles capable of transporting payloads weighing 500 kilograms or more for 300 kilometers or more)

ニ ロケット若しくは無人航空機のレードーム（五〇〇キログラム以上のペイロー

ドを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。) に使用するためのセラミックの複合材料(一〇〇メガヘルツ以上一〇〇ギガヘルツ以下の範囲のいずれかの周波数における比誘電率が六未満のものに限る。) 又はロケット若しくは無人航空機の先端部(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。) に使用することができる炭化けい素で強化された未焼成セラミック

- (d) Composites of ceramics (limited to those with relative permittivity less than 6 in frequencies within the range of 100 megahertz or more and 100 gigahertz or less) for use in radomes (limited to those usable in rockets or unmanned aerial vehicles capable of transporting payloads weighing 500 kilograms or more for 300 kilometers or more) of rockets or unfired ceramics strengthened with silicon carbide usable for nose tips of rockets or unmanned aerial vehicles (limited to those capable of transporting payloads weighing 500 kilograms or more for 300 kilometers or more)

ホ 粒子の径が五〇〇マイクロメートル以下の粉末状のタングステン、モリブデン又はこれらの合金であって、純度が九七パーセント以上のもののうち、ロケット推進装置の部分品の製造に使用することができるもの(噴霧粉又は球形粉であり、かつ、五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)

- (e) Among tungsten or molybdenum or alloys thereof, in a powdered form the particle diameter of which is 500 micrometers or less (limited to atomized powders or globular powders usable in rockets or unmanned aerial vehicles capable of transporting payloads weighing 500 kilograms or more for 300 kilometers or more), with purity of 97 % or more, those usable for the production of parts for rocket propulsion units

ヘ 二〇度の温度において測定した最大引張強さが一、五〇〇、〇〇〇、〇〇〇パスカル以上のマルエージング鋼(厚さが五ミリメートル以下の板又は管であり、かつ、五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)

- (f) Maraging steels (limited to boards or plates with thickness of 5 mm or less usable in rockets or unmanned aerial vehicles capable of transporting payloads weighing 500 kilograms or more for 300 kilometers or more) with a maximum tensile strength as measured at 20 degrees centigrade of 1,500,000,000 pascals or more

ト チタンにより安定化されたオーステナイト・フェライト系ステンレス鋼であって、次の(一)及び(二)に該当するもの(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)

- (g) Austenitic-ferritic stainless steels stabilized by titanium, and that fall under the following 1 and 2 (limited to those usable in rockets or

unmanned aerial vehicles capable of transporting payloads weighing 500 kilograms or more for 300 kilometers or more)

(一) 次の1から3までのすべてに該当するもの

1. Steels falling under all of the following i. through iii.

1 クロムの含有量が全重量の一七パーセント以上二三パーセント以下で、かつ、ニッケルの含有量が全重量の四・五パーセント以上七パーセント以下のもの

i. Steels with a chrome content of 17 % or more and 23 % or less of the total weight and a nickel content of 4.5 % or more and 7 % or less of the total weight

2 チタンの含有量が全重量の〇・一パーセントを超えるもの

ii. Steels with a titanium content exceeding 0.1 % of the total weight

3 オーステナイト組織を示す部分が全体積の一〇パーセント以上のもの

iii. Steels with parts indicating an austenite structure of 10% or more of the total volume

(二) 次のいずれかに該当するもの

2. Steels falling under any of the following

1 塊又は棒であって、寸法の最小値が一〇〇ミリメートル以上のもの

i. Ingots or rods with a smallest dimension value of 100 millimeters or more

2 シートであって、幅が六〇〇ミリメートル以上で、かつ、厚さが三ミリメートル以下のもの

ii. Sheets with a width of 600 millimeters or more and a thickness of 3 millimeters or less

3 管であって、外径が六〇〇ミリメートル以上で、かつ、厚さが三ミリメートル以下のもの

iii. Tubes with an external diameter of 600 millimeters or more and a thickness of 3 millimeters or less

十七 加速度計若しくはジャイロスコープ若しくはこれらを用いた装置若しくは航法装置であって、次のいずれかに該当するもの（ロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。）又はこれらの部分品

(xvii) Accelerometers or gyroscopes, or equipment or navigation equipment using them, that falls under any of the following (limited to those usable in rockets or unmanned aerial vehicles) or components thereof

イ 五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用するように設計した航法装置であって、ジャイロスタビライザー又は自動操縦装置とともに使用するように設計したもの

(a) Navigation equipment designed for use in rockets or unmanned aerial vehicles capable of transporting payloads weighing 500 kilograms or more for 300 kilometers or more and designed for use in a gyrostabilizer or automated flight controller



ロ ジャイロ天測航法装置又は天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置

(b) Gyro-astro compasses, or devices that derive position or orientation by means of automatically tracking celestial bodies or satellites

ハ 直線加速度計であつて、慣性航法装置用又は誘導装置用に使用するよう設計したもののうち、スケールファクターの再現性が〇・一二五パーセント未満であつて、バイアスの再現性が〇・〇一二二六三メートル毎秒毎秒未満のもの（ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。）

(c) Linear accelerometers designed for use in inertial navigation systems or guidance systems with scale factor reproducibility less than 0.125 % and bias reproducibility less than 0.012263 meters per second squared (limited to those usable in rockets or unmanned aerial vehicles capable of transporting payloads for 300 kilometers or more)

ニ ジャイロスコープであつて、九・八一メートル毎秒毎秒の直線加速度の状態におけるドリフトレートの安定性が一時間につき〇・五度未満のもの（ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。）

(d) Gyroscopes with drift rate stability less than 0.5 degrees per hour in a state of linear acceleration of 9.81 meters per second squared (limited to those usable in rockets or unmanned aerial vehicles capable of transporting payloads for 300 kilometers or more)

ホ 加速度計又はジャイロスコープであつて、九八一メートル毎秒毎秒を超える直線加速度で使用することができるように設計したもの

(e) Accelerators or gyroscopes designed to be capable of use with linear acceleration exceeding 981 meters per second squared

ヘ ハ若しくはホに該当する加速度計又はニ若しくはホに該当するジャイロスコープを用いた装置

(f) Equipment using accelerometers falling under (c) or (e) or gyroscopes falling under (d) or (e)

十七の二 五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用するよう設計した統合された航法システムであつて、平均誤差半径が二〇〇メートル以下の精度のもの

(xvii)-2 Integrated navigation systems designed for use in rockets or unmanned aerial vehicles capable of transporting payloads weighing 500 kilograms or more for 300 kilometers or more, and with precision of an average error radius of 200 meters or less

十七の三 加速度計若しくはジャイロスコープ若しくはこれらを用いた装置若しくは航法装置の製造用の装置若しくは工具、試験装置若しくは校正装置、心合わせ装置又はこれらの部分品であつて、次のいずれかに該当するもの

(xvii)-3 Accelerometers or gyroscopes or equipment using those, or equipment

or tools for the production of navigation systems, or test equipment, calibration equipment, or alignment equipment thereof, or components thereof, falling under any of the following

イ 前二号に該当するものの製造用の装置若しくは工具、試験装置、校正装置若しくは心合わせ装置（ロからへまでのいずれかに該当するものを除く。）又はこれらの部分品

(a) Production equipment or tools or test equipment, calibration equipment, or alignment equipment for those falling under preceding two items (excluding those falling under any of the following (b) through (f)), or components thereof

ロ 遠心力式釣合い試験機（歯科用装置又は医療用装置を試験するように設計したものを除く。）であって、次の（一）から（四）までのすべてに該当するもの

(b) Centrifugal balancing machines (excluding those designed for testing dental equipment or medical equipment) falling under all of the following 1 through 4

（一） 重量が三キログラムを超えるロータを試験することができないもの

1. Machines that are not capable of testing rotors exceeding 3 kilograms

（二） 一分につき一二、五〇〇回転を超える回転数でロータを試験することができるもの

2. Machines capable of testing rotors with speed exceeding 12,500 rotations per minute

（三） 二面以上での不釣合いを試験できるもの

3. Machines capable of testing imbalance on 2 or more planes

（四） ロータの重量に対する残留不釣合いが一キログラムにつき〇・ニグラムミリメートル以下のもの

4. Machines with residual imbalance with respect to the rotor weight of 0.2 gram-millimeters per kilogram or less

ハ 表示装置であって、ロに該当するものに使用することができるように設計したもの

(c) Display equipment designed to be capable of use in machines falling under (b)

ニ モーションシミュレーター又はレートテーブルであって、次の（一）から

（三）までのすべてに該当するもの（工作機械又は医療用装置に使用するように設計したものを除く。）

(d) Motion simulators or rate tables falling under all of the following 1 through 3 (excluding those designed to be usable for machine tools or medical devices)

（一） 軸数が二以上のもの

1. Motion simulators or rate tables with 2 or more axes

（二） 電気の供給又は信号情報の伝達を行うことができるスリップリングを有するもの

2. Motion simulators or rate tables having a slip ring capable of supplying electricity or transmitting signal information

(三) 次のいずれかに該当するもの

3. Motion simulators or rate tables falling under any of the following

1 いずれかの軸における角速度が一秒につき四〇〇度以上又は三〇度以下のものであって、当該角速度の分解能が一秒につき六度以下のものうち、当該角速度の精度が一秒につき〇・六度以下のもの

i. Motion simulators or rate tables the angular velocity in any axles of which is 400 degrees or more or 30 degrees or less per second, wherein the resolution of the angular velocity is 6 degrees per second or less, and the precision of the angular velocity is 0.6 degrees per second or less

2 いずれかの軸が一〇度以上回転する場合における角速度が、〇・〇五パーセント以下の精度で安定するもの

ii. Motion simulators or rate tables angular velocity of which is stabilized at the precision of 0.05 % or less when the rotation of any axes is 10 degrees or more

3 角度の位置決め精度が五秒以下のもの

iii. Motion simulators or rate tables with angular positioning precision of 5 seconds or less

ホ ポジショニングテーブルであって、次の（一）及び（二）に該当するもの（工作機械又は医療用装置に使用するように設計したものを除く。）

(e) Positioning tables falling under the following 1 and 2 (excluding those designed for use in machine tools or medical devices)

(一) 軸数が二以上のもの

1. Positioning tables with 2 or more axles

(二) 角度の位置決め精度が五秒以下のもの

2. Positioning tables with angular positioning precision of 5 seconds or less

へ 遠心加速度試験機であって、九八〇メートル毎秒毎秒を超える加速度を与えることができ、電気の供給及び信号情報の伝達を行うことができるスリップリングを有するもの

(f) Centrifugal accelerator testing machines capable of applying an acceleration rate exceeding 980 meters per second squared, and that have a slip ring capable of supplying electricity and transmitting signal information

十八 五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用するように設計した飛行制御装置又は姿勢制御装置

(xviii) Flight controllers or attitude controllers designed for use in a rocket or unmanned aerial vehicle capable of transporting payloads weighing 500 kilograms or more for 300 kilometers or more

十八の二 前号に掲げるものに使用するよう設計したサーボ弁であって、周波数範囲が二〇ヘルツ以上二、〇〇〇ヘルツ以下の全域において加速度の実効値が九八メートル毎秒毎秒を超える振動に耐えることができるよう設計したもの

(xviii)-2 Servo valves designed for use for those listed in the preceding item, and designed to be able to withstand vibrations with the effective rate of acceleration exceeding 98 meters per second squared within the frequency range from 20 hertz to 2,000 hertz

十八の三 前二号に掲げるものの試験装置、校正装置又は心合わせ装置

(xviii)-3 Test equipment, calibration equipment, or alignment equipment for those listed in preceding two items

十九 アビオニクス装置であって、次のいずれかに該当するもの

(xix) Avionics equipment falling under any of the following

イ レーダー（五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用するよう設計したものに限る。）

(a) Radars (limited to those usable for rockets or unmanned aerial vehicles capable of transporting payloads weighing 500 kilograms or more for 300 kilometers or more)

ロ パッシブセンサーであって、特定の電磁波源の方向又は地形の特性を探知するもの（五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用するよう設計したものに限る。）

(b) Passive sensors for detecting the direction of a specific electromagnetic wave source or landform characteristics (limited to those designed for use in rockets or unmanned aerial vehicles capable of transporting payloads weighing 500 kilograms or more for 300 kilometers or more)

ハ 衛星航法システムからの電波を受信する装置であって、次の（一）若しくは（二）に該当するもの又はそのために特に設計した部分品

(c) Equipment for receiving radio waves from satellite navigational systems falling under the following 1 or 2, or components especially designed therefor

（一） 五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用するよう設計したもの

1. Equipment designed for use in rockets or unmanned aerial vehicles capable of transporting payloads weighing 500 kilograms or more for 300 kilometers or more

（二） 航行又は飛しょうする移動体に使用するよう設計したものであって、次のいずれかに該当するもの

2. Equipment designed for use in mobile bodies that navigate or fly and that falls under any of the following

1 毎秒六〇〇メートルを超える速度のもとで、航法に係る情報を提供することができるもの

- i. Equipment capable of providing information pertaining to navigation based on speeds exceeding 600 meters per second
  - 2 軍隊又は政府機関による使用を目的として設計若しくは改良され、かつ、衛星航法システムで用いられる暗号化された信号又はデータにアクセスするための暗号の復号機能を有するもの（民生用途又は生命若しくは身体の安全を確保するための航法データを受信するように設計したものを除く。）
- ii. Equipment designed or improved for the purpose of use by the military or a governmental institution, and that has a function for decoding codes for accessing encoded signals or data used in a satellite navigational system (excluding those designed to receive navigational data for private use or for ensuring the safety of human life and physical safety)
  - 3 意図的な妨害を受ける環境のもとで機能することを目的として、ナルステアラブルアンテナ、電子的に走査が可能なアンテナその他妨害除去機能を有するように設計したもの（民生用途又は生命若しくは身体の安全を確保するための航法データを受信するように設計したものを除く。）
- iii. Equipment designed such as to have a null-steerable antenna, an antenna capable of electronic scanning, or other functions of impedance elimination for the purpose of functioning in an environment where intentional impedance is received (excluding those designed so as to receive navigational data for private use or for ensuring the safety of human life and physical safety)

二十 航空機搭載用又は船舶搭載用の重力計又は重力勾配計であって、精度が〇・七ミリガル以下のもののうち、測定所要時間が二分以内のもの（五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるように設計したものに限る。）又はこれらの部分品

(xx) Among gravity meters or gravity gradiometers for aircraft or ship mounting with precision of 0.7 milligals or less, those the time required for measurement of which is within 2 minutes (limited to those designed to be usable in rockets or unmanned aerial vehicles capable of transporting payloads weighing 500 kilograms or more for 300 kilometers or more) or components thereof

二十一 ロケット又は無人航空機の発射台又は地上支援装置であって、次のいずれかに該当するもの

(xxi) Launch pads or associated ground launch support equipment for rockets or unmanned aerial vehicles falling under any of the following

イ ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機の取扱い、制御、作動又は発射用に設計した装置

(a) Equipment designed for handling, controlling, operating, or launching rockets or unmanned aerial vehicles capable of transporting payloads for

300 kilometers or more

ロ 五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機の輸送、取扱い、制御、作動又は発射用に設計した車両

(b) Vehicles designed for transporting, handling, controlling, operating, or launching rockets or unmanned aerial vehicles capable of transporting payloads weighing 500 kilograms or more for 300 kilometers or more

二十二 ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用するように設計した無線遠隔測定装置又は無線遠隔制御装置（地上装置を含む。）であって、次のいずれにも該当しないもの

(xxii) Radio telemetry equipment or radio telecontrollers (including ground equipment) designed for use in rockets or unmanned aerial vehicles capable of transporting payloads for 300 kilometers or more and that does not fall under any of the following

イ 有人航空機又は人工衛星に使用するように設計したもの

(a) Equipment designed for use in manned aircraft or artificial satellites

ロ 陸上又は海洋において用いられる移動体に使用するように設計したもの

(b) Equipment designed for use in mobile bodies used on land or the sea

ハ 民生用途又は生命若しくは身体の安全を確保するための航法データを提供する衛星航法システムからの情報を受信するように設計したもの

(c) Equipment designed to receive information from satellite navigational systems for providing navigational data for private use or for ensuring the safety of human life and physical safety

二十二の二 ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができる追跡装置であって、次のいずれかに該当するもの

(xxii)-2 Tracking devices usable in rockets or unmanned aerial vehicles capable of transporting payloads for 300 kilometers or more, falling under any of the following

イ ロケット又は無人航空機に搭載されたコード変換器を使用するものであって、地上、海上若しくは飛しょう体上の連携機器又は衛星航法システムとの相互連携の下で、即時に飛行位置及び速度のデータを計測することができるもの

(a) Tracking devices using code converters mounted in rockets or unmanned aerial vehicles and capable of instantly measuring flight position and speed data in a mutual coordination with linked devices on ground, the sea or aircraft, or with a satellite navigational system

ロ 距離測定用のレーダーであって、光を利用した追跡装置を有するもののうち、次の（一）から（三）までのすべてに該当するもの

(b) Among radars for distance measurement having a tracking device utilizing light, those falling under all of the following 1 through 3

（一） 角度分解能が三ミリラジアン未満のもの

1. Radars with angular resolution less than 3 milliradians

(二) 距離分解能の二乗平均が一〇メートル未満で測定することができる距離が三〇キロメートル以上のもの

2. Radars with the square mean value of distance resolution less than 10 meters and capable of measuring distances 30 kilometers or more

(三) 速度分解能が一秒につき三メートル未満のもの

3. Radars with speed resolution less than 3 meters per second

二十三 五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットに搭載するように設計したアナログ電子計算機又はデジタル電子計算機であって、次のいずれかに該当するもの

(xxiii) Analog computers or digital computers designed for use in a rocket capable of transporting payloads weighing 500 kilograms or more for 300 kilometers or more falling under any of the following

イ 零下四五度より低い温度から五五度を超える温度まで使用することができるように設計したもの

(a) Computers designed to be usable from below -45 degrees centigrade to over 55 degrees centigrade

ロ 全吸収線量がシリコン換算で五〇万ラド以上となる放射線照射に耐えることができるように設計したもの

(b) Computers designed to be able to withstand radiation irradiation total absorbed dose of which on a silicon conversion basis is 500,000 rads or more

二十四 アナログデジタル変換用の集積回路又はアナログデジタル変換器（五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。）であって、次のいずれかに該当するもの

(xxiv) Integrated circuits for analog-to-digital conversion or analog-to-digital converters (limited to those usable in rockets or unmanned aerial vehicles capable of transporting payloads weighing 500 kilograms or more for 300 kilometers or more), and that fall under any of the following

イ アナログデジタル変換用の集積回路であって、全吸収線量がシリコン換算で五〇万ラド以上となる放射線照射に耐えることができるように設計したもの又は次の（一）から（三）までのすべてに該当するもの

(a) Integrated circuits for analog-to-digital conversion designed to be able to withstand radiation exposure, the total absorbed dose of which is 500,000 rads or more on a silicon conversion basis or those falling under all of the following 1 through 3

(一) 分解能が八ビット以上のもの

1. Integrated circuits with a resolution of 8 bits or more

(二) 零下五四度より低い温度から一二五度を超える温度まで使用することができるように設計したもの

2. Integrated circuits designed to be usable from below -54 degrees centigrade to over 125 degrees centigrade

(三) 気密封止したもの

3. Integrated circuits that are sealed airtight

ロ 電気入力型のアナログデジタル変換用の組立品又はモジュールであって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの

(b) Assemblies or modules for electronic input-type analog-to-digital conversion and that fall under all of the following 1 through 3

(一) 分解能が八ビット以上のもの

1. Assemblies or modules with a resolution of 8 bits or more

(二) 零下四五度より低い温度から五五度を超える温度まで使用することができるように設計したもの

2. Assemblies or modules designed to be usable from below -45 degrees centigrade to over 55 degrees centigrade

(三) イに該当する集積回路を組み込んだもの

3. Assemblies or modules that incorporate integrated circuit falling under (a)

二十五 振動試験装置若しくはその部分品、風洞、燃焼試験装置、環境試験装置又は電子加速器若しくはこれを用いた装置（それぞれ五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機、第二号イに該当する貨物（五〇〇キログラム以上のペイロードを運搬することができるロケットに使用することができるものに限る。）又は同号ロに該当する貨物の開発又は試験に用いることができるものに限る。）であって、次のいずれかに該当するもの

(xxv) Vibration test equipment or components thereof, wind tunnels, combustion test equipment, environmental test equipment, electron accelerators or equipment using those (limited to those usable in the development or testing rockets or unmanned aerial vehicles capable of transporting payloads weighing 500 kilograms or more for 300 kilometers or more, goods (limited to those usable for rockets capable of transporting payloads weighing 500 kilograms or more) falling under item (ii) (a), goods falling under item (ii), (b)) and that fall under any of the following

イ 振動試験装置又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの

(a) Vibration test equipment or components thereof falling under any of the following

(一) デジタル制御方式の振動試験装置であって、次の1及び2に該当するもの

1. Digitally controlled vibration test equipment falling under the following i and ii

1 試験体がない状態における加振力が五〇キロニュートン以上のものであって、二〇ヘルツ以上二、〇〇〇ヘルツ以下のいずれの周波数においても加



速度の実効値が九八メートル毎秒毎秒以上の振動を発生させることができるもの

- i. Equipment with exciting force of 50 kilonewtons or more in a state with no test object present and capable of generating vibrations with effective rate of acceleration of 98 meters per second squared or more even at a frequency of 20 hertz or more and 2,000 hertz or less
- 2 フィードバック制御技術又は閉ループ制御技術を用いたもの
- ii. Equipment using feedback control technology or closed loop control technology

(二) 振動試験装置の部分品であって、次のいずれかに該当するもの

2. Components of vibration test equipment falling under any of the following

- 1 (一) に該当する振動試験装置の制御に使用するよう設計した部分品であって、振動試験用のプログラムを用いたものであり、かつ、五キロヘルツを超える帯域幅で実時間での振動試験をデジタル制御するもの

- i. Components designed for use in controlling the vibration test equipment falling under 1 and that use a program for vibration testing and digitally control vibration testing in real time in a bandwidth exceeding 5 kilohertz

- 2 (一) に該当する振動試験装置に使用することができる振動発生機であって、試験体がない状態における加振力が五〇キロニュートン以上のもの

- ii. Vibration generators usable for vibration test equipment falling under 1., with exciting force of 50 kilonewtons or more in a state with no test object present

- 3 (一) に該当する振動試験装置に使用することができる振動台又は振動発生装置の部分品であって、試験体がない状態における加振力が五〇キロニュートン以上となる振動を発生させるために二台以上の振動発生機を接続して使用するよう設計したもの

- iii. Parts of vibration tables or vibration generators usable for vibration test equipment falling under 1. and designed for use by connecting 2 or more vibration generators in order to generate vibrations with exciting force of 50 kilonewtons or more in a state with no test object present

ロ マッハ数が〇・九以上の速度の状態を作ることができる風洞

(b) Wind tunnels capable of creating a state wherein the speed is Mach 0.9 or more

ハ 燃焼試験装置であって、推力が九〇キロニュートンを超える固体ロケット、液体ロケット若しくはロケット推進装置を試験することができるもの又は同時に三軸方向の推力成分を測定することができるもの

(c) Combustion test equipment capable of testing solid rockets, liquid rockets with thrust exceeding 90 kilonewtons or rocket propulsion units or capable

of measuring the thrust components in the three axial directions simultaneously

ニ 飛行の状態をシミュレートすることができる環境試験装置であって、次の  
(一) 及び (二) に該当するもの

(d) Environmental test equipment capable of simulating flying state and that falls under the following 1 and 2

(一) 高度が一五、〇〇〇メートル以上の状態又は零下五〇度以上一二五度以下のすべての温度範囲の状態をシミュレートすることができるもの

1. Equipment capable of simulating states wherein the altitude is 15,000 meters or more or states with temperatures throughout the range of - 50 degrees centigrade or more and 125 degrees centigrade or less

(二) 周波数範囲が二〇ヘルツ以上二、〇〇〇ヘルツ以下で、かつ、試験体がない状態における加速度の実効値が九八メートル毎秒毎秒以上の振動を発生させることができるもの（加振力が五キロニュートン以上のものに限る。）又は基準音圧が二〇マイクロパスカルの場合の音圧レベルが一四〇デシベル以上の音を発生させることができるもの若しくは定格の音響出力の合計が四キロワット以上のもの

2. Equipment (limited to those with exciting force of 5 kilonewtons or more) capable of generating vibrations with frequency range between 20 hertz and 2,000 hertz and effective rate of acceleration of 98 meters per second squared or more in a state with no test object present, or those capable of generating sounds with sound pressure level of 140 decibels or more when the reference sound pressure is 20 micropascals, or those with total rated acoustic output of 4 kilowatts or more

ホ 電子加速器であって、二メガエレクトロンボルト以上のエネルギーを有する加速された電子からの制動放射によって電磁波を放射することができるもの又はこれを用いた装置（医療用に設計したものを除く。）

(e) Electron accelerators capable of emitting electromagnetic waves by means of a bremsstrahlung from accelerated electrons having energy of 2 mega electron volts or more or equipment using those (excluding those designed for medical use)

二十五の二 五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット、第二号イに該当する貨物（五〇〇キログラム以上のペイロードを運搬することができるロケットに使用することができるものに限る。）又は同号ロに該当する貨物を設計するためのハイブリッド電子計算機（第十六条第一項第十一号に該当するプログラムを有するものに限る。）

(xxv)-2 Rockets capable of transporting payloads weighing 500 kilograms or more for 300 kilometers or more, goods (limited to those usable in rockets capable of transporting payloads weighing 500 kilograms or more) falling under item (ii) (a), or hybrid computers (limited to those having programs falling under Article 16, paragraph (1), item (xi)) for the design of goods

falling under item (ii) (b)

二十六 電波、音波（超音波を含む。）若しくは光（紫外線及び赤外線に限る。）の反射若しくは放射を減少させるステルス技術を用いた材料若しくは装置であって、ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機、第一号の三に該当する無人航空機、第二号イに該当する貨物（ペイロードを運搬することができるロケットに使用することができるものに限る。）若しくは同号ロに該当する貨物に使用することができるもの又はこれらの試験装置

(xxvi) Materials or equipment using stealth technology for reducing the level of the reflection or emission of radio waves, acoustic waves (including ultrasound), or light (limited to ultraviolet and infrared light) usable in rockets or unmanned aerial vehicles capable of transporting payloads for 300 kilometers or more, unmanned aerial vehicles falling under item (i)-3, goods (limited to those usable for a rocket capable of transporting payloads) falling under item (ii) (a), or goods falling under item (ii) (b), or test equipment thereof

二十七 集積回路、探知装置又はレードーム（五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。）であって、次のいずれかに該当するもの

(xxvii) Integrated circuits, detectors, or radomes (limited to those usable in rockets or unmanned aerial vehicles capable of transporting payloads weighing 500 kilograms or more for 300 kilometers or more) that fall under any of the following

イ 全吸収線量がシリコン換算で五〇万ラド以上となる放射線照射に耐えることができるように設計した集積回路であって、ロケット又は無人航空機を核の影響から防護するために使用することができるもの

(a) Integrated circuits designed to be able to withstand radiation exposure with total absorbed dose of 500,000 rads or more on a silicon conversion basis, and usable for protecting rockets or unmanned aerial vehicles from a nuclear impact

ロ ロケット又は無人航空機を核の影響から防護するために設計した探知装置

(b) Detectors designed to protect rockets or unmanned aerial vehicles from a nuclear impact

ハ 五〇キロパスカルを超える圧力において一平方メートル当たり四、一八四キロジュールを超える熱衝撃に耐えることができるように設計したレードームであって、ロケット又は無人航空機を核の影響から防護するために使用することができるもの

(c) Radomes designed to be able to withstand a thermal shock exceeding 4,184 kilojoules per square meter at a pressure exceeding 50 kilopascals and usable to protect rockets or unmanned aerial vehicles from a nuclear impact

第四条 輸出令別表第一の五の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

Article 4 Goods with specifications prescribed by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 5 of the appended table 1 of the Export Order shall fall under any of the following.

一 ふっ素化合物の製品であって、次のいずれかに該当するもの

(i) Fluorine compound products that fall under any of the following

イ 航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体を使用するように設計したものであって、第十四号ロ又はハに該当するふっ素化合物の含有量が全重量の五〇パーセントを超えるシール、ガスケット、シーラント又は燃料貯蔵袋

(a) Products designed for use in aircraft, satellites and other types of spacecraft for space development, and seals, gaskets, sealants or fuel storage bags with a content of fluorine compounds and that fall under item (xiv), (b) or (c) exceeding 50% of the total weight

ロ 第十四号イに該当するビニリデンフルオリドの共重合体からなる圧電重合体又は圧電共重合体であって、次の（一）及び（二）に該当するもの

(b) Piezoelectric polymers or piezoelectric copolymers made of vinylidene fluorides falling under item (xiv), (a) and that fall under following 1. or 2.

（一） シート又はフィルム状のもの

1. Polymers that are sheet or film shaped

（二） 厚さが二〇〇マイクロメートルを超えるもの

2. Polymers with a thickness exceeding 200 micrometers

ハ ビニルエーテルのモノマーを含むゴム状のふっ素化合物からなるシール、ガスケット、バルブシート、貯蔵袋又はダイヤフラムであって、航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体を使用するように設計したもの

(c) Seals, gaskets, valve seats, storage bags or diaphragms made of any rubbery fluorine compound that contains vinyl ether monomer, and those designed for use for aircraft, satellites and other types of spacecraft for space development

二 繊維を使用した成型品（半製品を含む。以下この号において同じ。）であって、次のいずれかに該当するもの

(ii) Molded products that use fibers (including semi-finished products; hereinafter the same shall apply in this item) that fall under any of the following

イ 第十五号ホに該当するプリプレグ又はプリフォームを使用した成型品であって、有機物をマトリックスとするもの

(a) Molded products that use prepregs or preforms and that fall under item (xv), (e) and whose matrix is a organic matter

ロ 次のいずれかに該当する繊維を使用した成型品であって、金属又は炭素をマトリックスとするもの

(b) Molded products that use fibers that fall under any of the following and

whose matrix is a metal or carbon

(一) 炭素繊維であって次の1及び2に該当するもの

1. Carbon fibers that fall under the following i. and ii.

1 比弾性率が一〇、一五〇、〇〇〇メートルを超えるもの

i. Carbon fibers with a specific elastic modulus exceeding 10,150,000 meters

2 比強度が一七七、〇〇〇メートルを超えるもの

ii. Carbon fibers with a specific strength exceeding 177,000 meters

(二) 第十五号ハに該当するもの

2. Those that fall under item (xv), (c)

三 第十三号イに該当する芳香族ポリイミドの製品（フィルム、シート、テープ又はリボン状のものに限る。）であって、次のいずれかに該当するもの（銅を被覆若しくはラミネートしたものであって、電子回路のプリント基板用のものを除く。）

(iii) Aromatic polyimide products that fall under item (iii), (a) (limited to films, sheets, tapes or ribbon shaped ones) and that fall under any of the following (excluding those that are copper coated or laminated and are for printed boards of electronic circuits)

イ 厚さが〇・二五四ミリメートルを超えるもの

(a) Products with a thickness exceeding 0.254 millimeters

ロ 炭素、黒鉛、金属又は磁性材料で被覆され、又はラミネートされたもの

(b) Products coated or laminated with carbon, graphite, metals or magnetic materials

四 第二号、第十五号又は第十四条第一号に該当するものの製造用の装置であって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品若しくは附属品

(iv) Devices for the manufacture of items that fall under item (ii), item (xv), or Article 14, item (i) and that fall under any of the following, or components or accessories thereof

イ フィラメントワインディング装置であって、繊維を位置決めし、包み及び巻く作業を行うもののうち、それらの作業を相関して制御することができる軸を三本以上有するもの

(a) Among filament winding devices that perform fiber positioning or wrapping or winding operations, those that have 3 or more shafts and are capable of controlling and correlating those operations

ロ 繊維からなる航空機の機体又はロケットの構造体を製造するためのものであって、テープ、トウ又はシートを位置決めし、及びラミネートする作業を行うもののうち、それらの作業を相関して制御することができる軸を二本以上有するもの

(b) Among devices for the manufacture of airframes of aircraft or the structure of rockets made of fibers that position tapes, tows, sheets and perform laminating operations, those that have 2 or more shafts capable of controlling and correlating those operations

ハ 三次元的に織ることができる織機又はインターレーシングマシン

- (c) Looms or interlacing machines capable of weaving three dimensionally  
ニ 繊維の製造用の装置であって、次のいずれかに該当するもの
- (d) Fiber manufacturing devices that fall under any of the following
- (一) 重合体繊維から炭素繊維又は炭化けい素繊維を製造する装置
    1. Devices that manufacture carbon fibers or silicon carbide fibers from polymer fibers
    - (二) 炭化けい素繊維の製造用の装置であって、熱したフィラメント状の基材に元素又は化合物を化学的に蒸着させるもの
    2. Devices that manufacture silicon carbide fibers and that chemically vapor deposit elements or compounds on heated filament-shaped substrates
    - (三) 耐火セラミックの湿式紡糸装置
    3. Wet spinning equipment for fire resistant ceramics
    - (四) 熱処理によって、アルミニウムを含有するプリカーサー繊維からアルミナ繊維を製造する装置
    4. Devices that manufacture alumina fibers from precursor fibers containing aluminum by heat treatment
- ホ ホットメルト方式を用いて第十五号ホに該当するプリプレグを製造する装置
- (e) Devices that manufacture prepregs that use a hot melt method and fall under item (xv), (e)
- ヘ 三次元的に欠陥を検査することができる非破壊検査装置であって、超音波又はエックス線断層撮影法を用いるもののうち、複合材料を検査するように設計したもの
- (f) Among non-destructive inspection devices that are capable of inspecting defects three-dimensionally and use ultrasound or X-ray tomography, those designed for inspecting composite materials
- 五 合金又はその粉末の製造用の装置（コンタミネーション防止対策を講じてあるものに限る。）であって、第七号ハ（二）1から7までのいずれかに該当する方法において使用するように設計したもの
- (v) Devices for the manufacture of alloys or powders thereof (limited to those with contamination prevention measures taken) and designed for use in the methods that fall under any of item (vii), (c), 2., i. through vii.
- 六 チタン、アルミニウム又はこれらの合金を超塑性成形又は拡散接合するための工具（型を含む。）であって、次のいずれかに該当するものを製造するように設計したもの
- (vi) Tools (Including molds) for super plastic forming or diffusion bonding of titanium, aluminum or alloys thereof and designed to manufacture things that fall under any of the following
- イ 航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体の構造体
- (a) Structures of aircraft, satellites and other types of spacecraft for space development

ロ 航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体のエンジン

(b) Engines for aircraft, satellites and other types of spacecraft for space development

ハ イ又はロに該当するものの部分品

(c) Components of those falling under (a) or (b)

七 合金又はその粉末であって、次のいずれかに該当するもの（基材の表面に定着させるコーティング用のものを除く。）

(vii) Alloys or powders thereof that fall under any of the following (excluding those used for coating by fixing on the substrate surface)

イ アルミニウムの化合物となっている合金であって、次のいずれかに該当するもの

(a) Alloys that have become aluminum compounds that fall under any of the following

(一) アルミニウムの含有量が全重量の一五パーセント以上三八パーセント以下であって、アルミニウム又はニッケル以外の合金元素を含むニッケル合金

1. Nickel alloys that contains alloy elements other than aluminum or nickel with a content of aluminum of 15% or more and 38% or less of the total weight

(二) アルミニウムの含有量が全重量の一〇パーセント以上であって、アルミニウム又はチタン以外の合金元素を含むチタン合金

2. Titanium alloys that contain alloy elements other than aluminum or titanium with a content of aluminum of 10% or more of the total weight

ロ ハに該当するものからなる合金であって、次のいずれかに該当するもの

(b) Alloys made of metals that fall under (c) and that fall under any of the following

(一) ニッケル合金であって、次のいずれかに該当するもの

1. Nickel alloys that fall under any of the following

1 六五〇度の温度において六七六メガパスカルの応力が発生する荷重を加えたときの応力破断時間が一〇、〇〇〇時間以上のもの

i. Nickel alloys with a stress breakage time of 10,000 hours or more when a load is added that generates 676 megapascals stress at a temperature of 650 degrees centigrade

2 五五〇度の温度において一、〇九五メガパスカルの応力が発生する荷重を加えたときの低サイクル疲労寿命が一〇、〇〇〇サイクル以上のもの

ii. Nickel alloys with a low cycle fatigue life of 10,000 cycles or more when a load is added that generates 1,095 megapascals stress at a temperature of 550 degrees centigrade

(二) ニオブ合金であって、次のいずれかに該当するもの

2. Niobium alloys that fall under any of the following

1 八〇〇度の温度において四〇〇メガパスカルの応力が発生する荷重を加え

たときの応力破断時間が一〇、〇〇〇時間以上のもの

i. Niobium alloys with a stress breakage time of 10,000 hours or more when a load is added that generates 400 megapascals stress at a temperature of 800 degrees centigrade

2 七〇〇度の温度において七〇〇メガパスカルの応力が発生する荷重を加えたときの低サイクル疲労寿命が一〇、〇〇〇サイクル以上のもの

ii. Niobium alloy with a low cycle fatigue life of 10,000 cycles or more when a load is added that generates 700 megapascals stress at a temperature of 700 degrees centigrade

(三) チタン合金であって、次のいずれかに該当するもの

3. Titanium alloys that fall under any of the following

1 四五〇度の温度において二〇〇メガパスカルの応力が発生する荷重を加えたときの応力破断時間が一〇、〇〇〇時間以上のもの

i. Titanium alloys with a stress breakage time of 10,000 hours or more when a load is added that generates 200 megapascals stress at a temperature of 450 degrees centigrade

2 四五〇度の温度において四〇〇メガパスカルの応力が発生する荷重を加えたときの低サイクル疲労寿命が一〇、〇〇〇サイクル以上のもの

ii. Titanium alloys with a low cycle fatigue life of 10,000 cycles or more when a load is added that generates 400 megapascals stress at a temperature of 450 degrees centigrade

(四) アルミニウム合金であって、引張強さが次のいずれかに該当するもの

4. Aluminum alloys with a tensile strength falling under any of the following

1 二〇〇度の温度において二四〇メガパスカル以上のもの

i. Aluminum alloys with a tensile strength of 240 megapascals or more at a temperature of 200 degrees centigrade

2 二五度の温度において四一五メガパスカル以上のもの

ii. Aluminum alloys with a tensile strength of 415 megapascals or more at a temperature of 25 degrees centigrade

(五) マグネシウム合金であって、引張強さが三四五メガパスカル以上のもののうち、三パーセント食塩水中における腐食が一年につき一ミリメートル未満のもの

5. Among magnesium alloys with a tensile strength of 345 megapascals or more, those that incur corrosion of less than 1 millimeter per year when immersed in 3% brine

ハ 合金の粉末であって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの

(c) Alloy powders that fall under all of the following 1. through 3.

(一) 次のいずれかに該当するものからなるもの

1. Alloy powders made of materials that fall under any of the following

1 製造工程中に混入する金属以外の粒子(径が一〇〇マイクロメートルを超



えるものに限る。)の数が粒子一、〇〇〇、〇〇〇、〇〇〇個当たり三個未満のニッケル合金であって、アルミニウム及びニッケルを含む三種類以上の元素からなるもの

- i. Nickel alloys with a number of particles other than metals mixed during the manufacturing process of less than 3 per 1,000,000,000 particles (limited to those with a diameter exceeding 100 micrometers) and made of elements of 3 types or more including aluminum and nickel
- 2 アルミニウム、けい素又はチタンのいずれかの元素及びニオブを含む三種類以上の元素からなるニオブ合金
- ii. Niobium alloys comprised of 3 types or more of elements including niobium and any of aluminum, silicon or titanium
- 3 アルミニウム及びチタンを含む三種類以上の元素からなるチタン合金
- iii. Titanium alloys comprised of 3 or more types of elements including aluminum or titanium
- 4 マグネシウム、亜鉛又は鉄のいずれかの元素及びアルミニウムを含む三種類以上の元素からなるアルミニウム合金
- iv. Aluminum alloys comprised of 3 types or more of elements including aluminum and any of the elements of magnesium, zinc or iron
- 5 アルミニウム及びマグネシウムを含む三種類以上の元素からなるマグネシウム合金
- v. Magnesium alloys comprised of 3 or more types of elements including aluminum and magnesium

(二) 次のいずれかの方法によって製造したもの

2. Alloy powders manufactured by any of the following methods

- 1 真空噴霧法
- i. Vacuum atomization method
- 2 ガス噴霧法
- ii. Gas atomization method
- 3 回転噴霧法
- iii. Rotary atomization method
- 4 スプラットクエンチ法
- iv. Splat-quenching method
- 5 メルトスピニング法及び粉化法
- v. Melt spinning method and pulverization method
- 6 メルトエキストラクション法及び粉化法
- vi. Melt extraction method and pulverization method
- 7 機械的合金法
- vii. Mechanical alloy method

(三) イ又はロに該当するものを製造することができるもの

3. Alloy powders that can manufacture the alloys that fall under (a) or (b)

ニ 次の（一）から（三）までのすべてに該当する合金材料

(d) Alloy materials that fall under all of the following 1. through 3.

（一） ハ（一）1から5までのいずれかに該当するものからなるもの

1. Alloy materials made of alloy powders that fall under any of (c) 1. i. through v.

（二） 細かく砕かれていないフレーク状、リボン状又は細い棒状のもの

2. Alloy materials that are not finely pulverized but flake shaped, ribbon shaped or thin rod shaped

（三） 次のいずれかの方法によって製造されたもの

3. Alloy materials manufactured by any of the following methods

1 スプラットクエンチ法

i. Splat-quenching method

2 メルトスピニング法

ii. Melt spinning method

3 メルトエキストラクション法

iii. Melt extraction method

ハ 金属性磁性材料であって、次のいずれかに該当するもの

(viii) Metallic magnetic materials that fall under any of the following

イ 初透磁率が一二〇、〇〇〇以上のものであって、厚さが〇・〇五ミリメートル以下のもの

(a) Metallic magnetic materials with an initial magnetic permeability of 120,000 or more and with a thickness of 0.05 millimeters or less

ロ 磁歪合金であって、次のいずれかに該当するもの

(b) Magnetostrictive alloys that fall under any of the following

（一） 飽和磁気歪が〇・〇〇〇五を超えるもの

1. Those with a saturated magnetostriction exceeding 0.0005

（二） 電気機械結合係数が〇・八を超えるもの

2. Those with an electromechanical coupling coefficient exceeding 0.8

ハ ストリップ状のアモルファス合金又はナノクリスタル合金であって、次の

（一）及び（二）に該当するもの

(c) Strip-shaped amorphous alloys or nano crystal alloys that fall under the following 1. and 2.

（一） 鉄、コバルト若しくはニッケルのいずれかの含有量又はこれらの含有量の合計が全重量の七五パーセント以上のもの

1. Those with a content of any of iron, cobalt or nickel, or with a total content thereof, of 75% or more of the total weight

（二） 飽和磁束密度が一・六テスラ以上のものであって、次のいずれかに該当するもの

2. Those with a saturated magnetic flux density of 1.6 tesla or more that fall under any of the following

1 厚さが〇・〇二ミリメートル以下のもの

- i. Those with a thickness of 0.02 millimeters or less
    - 2 電気抵抗率が二マイクロオームメートル以上のもの
  - ii. Those with an electrical resistivity of 2 microohm-meters or more
- 九 ウランチタン合金又はタングステン合金であつて、そのマトリックスが鉄、ニッケル又は銅のもののうち、次のイからニまでのすべてに該当するもの
- (ix) Among uranium-titanium alloys or tungsten alloys whose matrix is of iron, nickel or copper, those that fall under all of the following (a) through (d)
- イ 密度が一七・五グラム毎立方センチメートルを超えるもの
    - (a) Those with a density exceeding 17.5 gram per cubic centimeter
    - ロ 弾性限度が八八〇メガパスカルを超えるもの
      - (b) Those with an elastic limit exceeding 880 megapascals
      - ハ 引張強さが一、二七〇メガパスカルを超えるもの
        - (c) Those with a tensile strength exceeding 1,270 megapascals
        - ニ 伸び率が八パーセントを超えるもの
          - (d) Those with a coefficient of extension exceeding 8 %
- 十 超電導材料であつて、次のいずれかに該当するもの（長さが一〇〇メートルを超えるもの又は全重量が一〇〇グラムを超えるものに限る。）
- (x) Superconductive materials that fall under any of the following (limited to those with a length exceeding 100 meters or with the total weight exceeding 100 grams)
- イ 複数のフィラメントを有するものであつて、ニオブチタンのフィラメントを含むもののうち、次のいずれかに該当するもの
    - (a) Among superconductive materials that have multiple filaments including niobium titanium filaments, those that fall under any of the following
      - (一) フィラメントが銅又は銅合金以外のマトリックスに埋めこまれたもの
        - 1. Those the filaments of which are embedded in a matrix other than copper or copper alloy
        - (二) フィラメントの断面積が一〇〇万分の二八平方ミリメートル未満のもの
          - 2. Those with a filament cross-section area less than 28/1,000,000 square millimeters
      - ロ ニオブチタン以外の超電導フィラメントからなる超電導材料であつて、次の
        - (一) から (三) までのすべてに該当するもの
          - (b) Superconductive materials comprised of superconductive filaments other than niobium titanium that fall under all of the following 1. through 3.
            - (一) 磁界をかけない場合に臨界温度が零下二六三・三一度超零下二四九・一六度未満のもの
              - 1. Those with a critical temperature exceeding -263.31 degrees centigrade and less than -249.16 degrees centigrade where a magnetic field is not applied
              - (二) 超電導フィラメントの断面積が一〇〇万分の二八平方ミリメートル未満のもの

2. Those with a cross-sectional area of superconductive filament less than 28/1,000,000 square millimeters

(三) 一二テスラの磁束密度の磁界をかけた場合に零下二六八・九六度の温度で超電導状態を保つことができるもの

3. Those that can hold superconductive condition with the temperature of -268.96 degrees centigrade, where a magnetic field of magnetic flux density of 12 tesla is applied

十一 作動油若しくは潤滑剤として使用することができる液体若しくは材料又は振動防止用若しくは冷媒用に使用することができる液体であって、次のいずれかに該当するもの

(xi) Liquids or materials that can be used as hydraulic oil or lubricants or liquids that can be used for preventing vibration or as coolant that fall under any of the following

イ 作動油として使用することができる液体であって、次のいずれかに該当するものを主成分とするもの

(a) Liquids that can be used as hydraulic oil and the primary component of which fall under any of the following

(一) シラハイドロカーボン油であって、次の1から4までのすべてに該当するもの

1. Sila-hydrocarbon oils that fall under all of the following i. through iv.

1 引火点が二〇四度を超えるもの

i. Those with an ignition point exceeding 204 degrees centigrade

2 流動点が零下三四度以下のもの

ii. Those with a pour point of -34 degrees centigrade or less

3 粘度指数が七五以上のもの

iii. Those with a viscosity index of 75 or more

4 三四三度の温度において安定性を有するもの

iv. Those that are stable at a temperature of 343 degrees centigrade

(二) クロロフルオロカーボンであって、次の1から5までのすべてに該当するもの

2. Chlorofluorocarbons that fall under all of the following i. through v.

1 引火点を有しないもの

i. Those that do not have an ignition point

2 自己発火温度が七〇四度を超えるもの

ii. Those with a self-ignition temperature exceeding 704 degrees centigrade

3 流動点が零下五四度以下のもの

iii. Those with a pour point of -54 degrees centigrade or less

4 粘度指数が八〇以上のもの

iv. Those with a viscosity index of 80 or more

5 沸点が二〇〇度以上のもの

- v. Those with a boiling point of 200 degrees centigrade or more
- ロ 潤滑剤として使用することができる材料であって、次のいずれかに該当する物質を主成分とするもの
- (b) Materials that can be used as a lubricant and the primary component of which falls under any of the following
- (一) フェニレンエーテル、アルキルフェニレンエーテル、フェニレンチオエーテル、アルキルフェニレンチオエーテル又はこれらの混合物であって、その有するエーテル基、チオエーテル基又はこれらの官能基の数の合計が三以上のもの
1. Phenylene ether, alkylphenylene ether, phenylene thioether, alkyl phenylene thioether or mixtures thereof, in which the total number of ether groups, or thioether groups or of these functional groups together is 3 or more
- (二) ふっ化シリコン油であって、二五度の温度において測定した動粘度が五、〇〇〇平方ミリメートル毎秒未満のもの
2. Fluorinated silicone oils with dynamic viscosity measured at a temperature of 25 degrees centigrade less than 5,000 square millimeters per second
- ハ 振動防止用に使用することができる液体であって、純度が九九・八パーセントを超え、かつ、径が二〇〇マイクロメートル以上の粒状の不純物の数が一〇〇ミリリットル当たり二五個未満のものうち、次のいずれかに該当する物質の重量が全重量の八五パーセント以上のもの
- (c) Among liquids usable for vibration prevention with a purity exceeding 99.8% and in which the number of particle impurities of diameter greater than 200 micrometers is less than 25 per 100 milliliters, those with a total content of substances that fall under any of the following that is 85% or more of the total weight
- (一) ジブロモテトラフルオロエタン
1. Dibromo tetrafluoro ethane
- (二) ポリクロロトリフルオロエチレン
2. Polychloro trifluoro ethylene
- (三) ポリブロモトリフルオロエチレン
3. Polybromo trifluoro ethylene
- ニ 電子機器の冷媒用に使用することができる液体であって、フルオロカーボンからなるものうち、次の(一)及び(二)に該当するもの
- (d) Among liquids usable for cooling electronic devices and made of fluorocarbons, those falling under the following 1. and 2.
- (一) 次のいずれかに該当する物質の含有量の合計が全重量の八五パーセント以上のもの
1. Liquids with a total content of substances that fall under any of the following that is 85% or more of the total weight

- 1 パーフルオロポリアルキルエーテルトリアジンのモノマー
    - i. Monomers of perfluoro polyalkyl ether triazine
    - 2 パーフルオロアリファティックエーテルのモノマー
      - ii. Monomers of perfluoro aliphatic ether
      - 3 パーフルオロアルキルアミン
        - iii. Perfluoro alkylamine
        - 4 パーフルオロシクロアルカン
          - iv. Perfluoro cycloalkane
          - 5 パーフルオロアルカン
            - v. Perfluoro alkane
  - (二) 次の1から3までのすべてに該当するもの
  2. Liquids that fall under all of the following i. through iii.
    - 1 二五度の温度における密度が、一ミリリットル当たり一・五グラム以上のもの
      - i. Those with a density at a temperature of 25 degrees centigrade of 1.5 grams or more per 1 milliliter
      - 2 零度の温度において液体のもの
        - ii. Those that are liquids at the temperature of 0 degrees centigrade
        - 3 ふっ素の含有量が全重量の六〇パーセント以上のもの
          - iii. Those with a fluorine content of 60% or more of the total weight
- 十二 セラミックの材料となる物質、セラミックの半製品若しくは一次製品又はセラミック複合材料であつて、次のいずれかに該当するもの
- (xii) Semi-finished ceramic products, primary ceramic products, ceramic composite materials, or substances that become ceramic materials, and that fall under any of the following
- イ チタンのほう化物であつて、金属不純物の含有量が全重量の〇・五パーセント未満のもののうち、粒子の径の平均値が五マイクロメートル以下であり、かつ、径が一〇マイクロメートルを超える粒子の重量の合計が全重量の一〇パーセント以下であるもの
    - (a) Among titanium borides with a content of metallic impurities less than 0.5% of the total weight, those with an average value of particle diameter of 5 micrometers or less and with a total weight of the particles with diameters exceeding 10 micrometers of 10% or less of the total weight
    - ロ チタンのほう化物からなるセラミックの半製品又は一次製品であつて、理論密度比が九八パーセント以上のもの（研磨材を除く。）
      - (b) Semi-finished or primary products of ceramics made of titanium boride with a theoretical density ratio of 98% or more (excluding grinding materials)
  - ハ セラミック複合材料であつて、ガラス又は酸化物をマトリックスとするものものうち、次のいずれかに該当するもの
    - (c) Among ceramic composite materials that have glasses or oxides as a

matrix, those that fall under any of the following

(一) 次の1及び2に該当する繊維により強化されたもの

1. Those that are reinforced by fibers that fall under the following i. or ii.

1 比強度が一二、七〇〇メートルを超えるもの

i. Those with a specific strength exceeding 12,700 meters

2 次の系のいずれかの元素の組合せからなるもの

ii. Those comprised of the combination of elements in any of the following systems

一 けい素及び窒素

a. Silicon and nitrogen

二 けい素及び炭素

b. Silicon and carbon

三 けい素、アルミニウム、酸素及び窒素

c. Silicon, aluminum, oxygen and nitrogen

四 けい素、酸素及び窒素

d. Silicon, oxygen and nitrogen

(二) 次の1又は2からなる連続した繊維（一、〇〇〇度の温度における引張強さが七〇〇メガパスカル未満のもの、又は一、〇〇〇度の温度において一〇〇メガパスカルの応力が発生する荷重を一〇〇時間にわたって加えたときに、クリープ歪みが一パーセントを超えるものを除く。）により強化されたもの

2. Those reinforced by continuous fibers made of the following i. or ii.

(excluding those with a tensile strength at a temperature of 1,000 degrees centigrade less than 700 megapascals or those with a creep distortion exceeding 1% when a load that generates stress of 100 megapascals is added for 100 hours at a temperature of 1,000 degrees centigrade)

1 酸化アルミニウム

i. Aluminum oxide

2 けい素、炭素及び窒素

ii. Silicon, carbon and nitrogen

ニ セラミック複合材料であって、粒子、ウイスキー又は繊維により強化されたもののうち、けい素、ジルコニウム又はほう素の炭化物又は窒化物をマトリックスとするもの

(d) Among ceramic composite materials reinforced by particles, whiskers or fibers, those having silicon, zirconium or boron carbide or nitride as a matrix

ホ ポリジオルガノシラン、ポリシラザン又はポリカルボシラザン

(e) Polydiorgano silane, polysilazane or polycarbo silazane

十三 重合体であって、次のいずれかに該当するもの

(xiii) Polymers that fall under any of the following

イ ビスマレイミド、芳香族ポリアミドイミド、芳香族ポリイミド又はガラス転移点が一四〇度を超える芳香族ポリエーテルイミド（圧縮成形を行う場合に液体とならない粉末状のもの又は成型品を除く。）

(a) Bismaleimide, aromatic polyamideimide, aromatic polyimide or aromatic polyetherimides with a glass transition point exceeding 240 degrees centigrade (excluding powdered polymers that do not become liquid in case of compression molding, or molded products)

ロ 熱可塑性の液晶共重合体であって、一・八二ニュートン毎平方ミリメートルの力を加えた場合における熱変形温度が一五〇度を超えるもののうち、次の（一）及び（二）からなるもの

(b) Thermoplastic crystal liquid copolymers made of the following 1. and 2., among those with a thermo deformation temperature exceeding 250 degrees centigrade where a force of 1.82 newtons per square millimeter is applied

（一） 次のいずれかに該当する物質

1. Substances that fall under any of the following

1 フェニレン、ビフェニレン又はナフタレン

i. Phenylene, biphenylene or naphthalene

2 メチル基、第三ブチル基又はフェニル基で置換されたフェニレン、ビフェニレン又はナフタレン

ii. Phenylene, biphenylene or naphthalene substituted by methyl group, tertiary butyl group or phenyl group

（二） 次のいずれかに該当する酸

2. Acids that fall under any of the following

1 テレフタル酸

i. Terephthalic acid

2 六ヒドロキシ二ナフトエ酸

ii. Hexahydroxy dinaphthoic acid

3 四ヒドロキシ安息香酸

iii. Tetrahydroxy benzoate

ハ ポリアリーレンエーテルケトンであって、次のいずれかに該当するもの

(c) Polyallylene ether ketones that fall under any of the following

（一） ポリエーテルエーテルケトン

1. Polyether ether ketone

（二） ポリエーテルケトンケトン

2. Polyether ketone ketone

（三） ポリエーテルケトン

3. Polyether ketone

（四） ポリエーテルケトンエーテルケトンケトン

4. Polyether ketone ether ketone ketone

ニ ポリアリーレンケトン



(d) Polyallylene ketone

ホ ビフェニレン、トリフェニレン又はこれらの組合せからなるアリーレン基を有するポリアリーレンスルフィド

(e) Polyallylene sulfide having allylene groups comprised of biphenylene, triphenylene or the combination thereof

ヘ ガラス転移点が二四〇度を超えるポリビフェニレンエーテルスルホン

(f) Polybiphenylene ether sulfone with a glass transition point exceeding 240 degrees centigrade

十四 ふっ素化合物であって、次のいずれかに該当するもの

(xiv) Fluorine compounds that fall under any of the following

イ ビニリデンフルオリドの共重合体であって、延伸しない状態でベータ型結晶構造を有する部分の重量が全重量の七五パーセント以上のもの

(a) Copolymers of vinylidene fluoride with a weight of the part having beta type crystal structure without being elongated of 75 % or more of the total weight

ロ 結合ふっ素の含有量が全重量の一〇パーセント以上のふっ化ポリイミド

(b) Fluorinated polyimides with a content of bonded fluorine of 10% or more of the total weight

ハ 結合ふっ素の含有量が全重量の三〇パーセント以上のふっ化ホスファゼンの弾性体

(c) Elastic bodies of fluorinated phosphazenes with a content of bonded fluorine of 30 % or more of the total weight

十五 繊維又はこれを使用したプリプレグ若しくはプリフォームであって、次のいずれかに該当するもの

(xv) Fibers or prepregs or preforms that use the fibers that fall under any of the following

イ 有機繊維（ポリエチレン繊維を除く。）であって、次の（一）及び（二）に該当するもの

(a) Organic fibers (excluding polyethylene fibers) that fall under any of the following 1. and 2.

（一） 比弾性率が一二、七〇〇、〇〇〇メートルを超えるもの

1. Those with a specific elastic modulus exceeding 12,700,000 meters

（二） 比強度が二三五、〇〇〇メートルを超えるもの

2. Those with a specific strength exceeding 235,000 meters

ロ 炭素繊維であって、次の（一）及び（二）に該当するもの

(b) Carbon fibers that fall under the following 1. and 2.

（一） 比弾性率が一二、七〇〇、〇〇〇メートルを超えるもの

1. Those with a specific elastic modulus exceeding 12,700,000 meters

（二） 比強度が二三五、〇〇〇メートルを超えるもの

2. Those with a specific strength exceeding 235,000 meters

ハ 無機繊維であって、次の（一）及び（二）に該当するもの

(c) Inorganic fibers that fall under the following 1. and 2.

(一) 比弾性率が二、五四〇、〇〇〇メートルを超えるもの

1. Those with a specific elastic modulus exceeding 2,540,000 meters

(二) 不活性の環境における融点、軟化点、分解点又は昇華温度が一、六四九度を超えるもの。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。

2. Those with melting points, softening points, decomposition points or sublimating temperature exceeding 1,649 degrees centigrade in an inactive environment, but excluding those that fall under any of the following.

1 比弾性率が一〇、〇〇〇、〇〇〇メートル未満のものであって、シリカの含有量が全重量の三パーセント以上の多相多結晶アルミナ繊維の短繊維であって、短く切断されたもの又はランダムマット形態のもの

i. Those with a specific elastic modulus of less than 10,000,000 meters, and that are the short fibers of multiphase polycrystalline alumina fibers with a content of silica of 3% or more of the total weight and that are cut up in short pieces or are random mat shaped

2 モリブデン繊維又はモリブデン合金繊維

ii. Molybdenum fibers or molybdenum alloy fibers

3 ボロン繊維

iii. Boron fibers

4 不活性の環境における融点、軟化点、分解点又は昇華温度が一、七七〇度未満のセラミック繊維の短繊維

iv. Short fibers of ceramic fibers with melting points, softening points, decomposition points or sublimating temperature exceeding 1,770 degrees centigrade in an inactive environment

ニ 次のいずれかに該当するものからなる繊維又は当該繊維とイからハまでのいずれかに該当する繊維とを混織した繊維

(d) Fibers made of those that fall under any of the following, or fibers woven by mixing the said fibers and fibers that fall under any of (a) through (c) above

(一) 第十三号イに該当する芳香族ポリエーテルイミド

1. Aromatic polyetherimides that fall under item (xiii), (a)

(二) 第十三号ロからハまでのいずれかに該当するもの

2. Fibers that fall under any of item (xiii), (b) through (f)

ホ プリプレグ又はプリフォームであって、次のいずれかに該当するもの

(e) Prepregs or preforms that fall under any of the following

(一) イからハまでのいずれかに該当する繊維からなるもの

1. Those made of fibers that fall under any of (a) through (c)

(二) 次の1及び2からなるもの

2. Those made of the following i. and ii.

1 次の一から三までのすべてに該当する有機繊維又は炭素繊維

i. Organic fibers or carbon fibers that fall under all of the following a. through c.

一 比弾性率が一〇、一五〇、〇〇〇メートルを超えるもの

a. Those with a specific elastic modulus exceeding 10,150,000 meters

二 比強度が一七七、〇〇〇メートルを超えるもの

b. Those with a specific strength exceeding 177,000 meters

三 イ又はロに該当しないもの

c. Those that do not fall under (a) or (b)

2 次のいずれかに該当する樹脂

ii. Resins that fall under any of the following

一 第十三号又は第十四号ロに該当するものであって、ガラス転移点が一〇〇度を超えるもの

a. Those that fall under item (xiii) or item (xiv), (b) with a glass transition point exceeding 110 degrees centigrade

二 フェノール樹脂又はエポキシ樹脂であって、ガラス転移点が一四五度（硬化温度がガラス転移点より低いものにあつては、一六〇度）以上のもの

b. Phenol resin or epoxy resin with a glass transition point of 145 degrees centigrade or more (for those the curing temperature of which is lower than the glass transition point, 160 degrees centigrade)

十六 粒子の径が六〇マイクロメートル以下のほう素若しくは炭化ほう素であつて、純度が八五パーセント以上のもの若しくはこれらの混合物、硝酸グアニジン又はニトログアニジン

(xvi) Boron or boron carbide with a particle diameter of 60 micrometers or less and with a purity of 85% or more, or a mixture thereof, or guanidine nitrate or nitro guanidine

第五条 輸出令別表第一の六の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

Article 5 Goods with specifications prescribed by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 6 of appended table 1 of the Export Order shall fall under any of the following.

一 軸受であつて、次のいずれかに該当するもの又はその部分品（国際規格 I S O 三二九〇（転がり軸受一軸受の部分品一転がり軸受用の玉）で定める精度がグレード五五以下の玉を除く。）

(i) Bearings that fall under any of the following, or components thereof (excluding balls of precision grade 55 or less as specified by ISO3290 (roller bearings -bearing components- balls for roller bearing units))

イ 玉軸受又はころ軸受（円すいころ軸受を除く。）であつて、日本工業規格 B 一五一四号（転がり軸受の精度）で定める精度が四級以上のもののうち、内外輪及び国際規格 I S O 五五九三で定める転動体がモネル製又はベリリウム製のもの

- (a) Among ball bearings or bearings (excluding tapered roller bearings) with a precision grade 4 or more as specified by Japanese Industrial Standards B 1514 (precision of roller bearings), those with inner and outer rings and rolling elements specified by International Standard ISO 5593 that are made of monel or beryllium
- ロ 玉軸受又はころ軸受（円すいころ軸受を除く。）であって、日本工業規格 B 一五一四号で定める精度が二級以上のもの（イに該当するものを除く。）
- (b) Ball bearings or bearings (excluding tapered roller bearings) with a precision grade 2 or higher as specified by Japanese Industrial Standards B 1514 (excluding those falling under (a))
- ハ 能動型の磁気軸受システムであって、次のいずれかに該当するもの
- (c) Active magnetic bearing systems that fall under any of the following
- (一) 磁束密度が二テスラ以上で、かつ、降伏点が四一四メガパスカルを超える材料からなるもの
1. Systems composed of materials with a magnetic flux density of 2 tesla or more and a yield point exceeding 414 megapascals
- (二) 全電磁式で、かつ、三次元ホモポーラバイアス励磁方式のアクチュエータを用いるもの
2. Systems that are entirely electromagnetic and employ a three-dimensional homopolar bias excitation actuator
- (三) 温度が一七七度以上で用いることができる位置検出器を有するもの
3. Systems having a position detector that can be used at temperatures of 177 degrees centigrade and higher
- 二 工作機械（金属、セラミック又は複合材料を加工することができるものに限る。）であって、電子制御装置を取り付けることができるもののうち、次のイからホまでのいずれかに該当するもの（へに該当するものを除く。）
- (ii) Among machine tools (limited to those that can process metals, ceramics or composite materials) to which a nelectronic controller can be attached, those that fall under any of the following (a) through (e) (excluding those that fall under (f))
- イ 旋削をすることができる工作機械であって、輪郭制御をすることができる軸数が二以上のもののうち、次のいずれかに該当するもの（コンタクトレンズの製造用に設計したものを除く。）
- (a) Among machine tools capable of lathe turning that have two or more axes capable of controlling contour, those that fall under any of the following (excluding those designed for the manufacture of contact lenses)
- (一) 削除
1. Deleted
- (二) 国際規格 I S O 二三〇／二（一九九七）で定める測定方法により測定したときの直線軸の位置決め精度が〇・〇〇四五ミリメートル以下のもの
2. Machine tools with a linear axis positioning precision of 0.0045

millimeters or less when measured according to the method of measurement specified by International Standard ISO 230-2:1997

ロ フライス削り又は中ぐりを行うことができる工作機械であって、次のいずれかに該当するもの

(b) Machine tools capable of milling or boring that fall under any of the following

(一) 輪郭制御を行うことができる直線軸の数が三で、かつ、輪郭制御を行うことができる回転軸の数が一のものであって、次のいずれかに該当するもの

1. Machine tools with 3 linear axes that are capable of controlling contour and one rotational axis that is capable of controlling contour and that fall under any of the following

1 削除

i. Deleted

2 国際規格 ISO 230/2 (1997) で定める測定方法により測定したときの直線軸の位置決め精度が 0.0045 ミリメートル以下のもの

ii. Machine tools with linear axis positioning precision of 0.0045 millimeters or less when measured according to the method of measurement specified by International Standard ISO 230-2:1997

(二) 輪郭制御を行うことができる軸数が五以上のもの

2. Machine tools with 5 or more axes capable of controlling contour

(三) ジグ中ぐり盤であって、国際規格 ISO 230/2 (1997) で定める測定方法により測定したときの直線軸の位置決め精度が 0.003 ミリメートル以下のもの

3. Jig boring machines with a linear axis positioning precision of 0.003 millimeters or less when measured according to the method of measurement specified by International Standard ISO 230-2:1997

(四) フライカッティングを行うように専用設計された工作機械であって、次の 1 及び 2 に該当するもの

4. Machine tools exclusively designed for fly cutting that fall under any of the following i. and ii.

1 スピンドルを一回転させた場合におけるスピンドルの半径方向及び軸方向の振れがそれぞれ 0.0004 ミリメートル未満のもの

i. Machine tools for which both the radial direction deflection and axial direction deflection are less than 0.0004 millimeters per single rotation of the spindle

2 300 ミリメートルを超える移動距離における真直度が二秒未満のもの

ii. Machine tools with straightness of less than 2 seconds over a travel distance exceeding 300 millimeters

ハ 研削を行うことができる工作機械であって、次の (一) 又は (二) に該当するもの (次の (三) から (五) までのいずれかに該当するものを除く。)

(c) Machine tools capable of grinding that fall under any of the following 1. or

2. (excluding those that fall under any of the following 3. through 5.)
- (一) 国際規格 I S O 二三〇/二 (一九九七) で定める測定方法により測定したときの直線軸の位置決め精度が〇・〇〇三ミリメートル以下のものであって、輪郭制御をすることができる軸数が三又は四のもの
1. Machine tools with a linear axis positioning precision of 0.003 millimeters or less when measured according to the method of measurement specified by International Standard ISO 230-2:1997, and with 3 or 4 axes capable of controlling contour
- (二) 輪郭制御をすることができる軸数が五以上のもの
2. Machine tools with 5 or more axes capable of controlling contour
- (三) 円筒外面研削盤、円筒内面研削盤又は円筒内外面研削盤であって、円筒で外径又は長さが一五〇ミリメートル以内のものを研削するように設計したもの
3. External cylindrical grinders, internal cylindrical grinders or internal-external cylindrical grinders designed to grind a cylinder with an external diameter or length of less than 150 millimeters
- (四) ジグ研削盤として使用するよう設計した工作機械であって、国際規格 I S O 二三〇/二 (一九九七) で定める測定方法により測定したときの位置決め精度が〇・〇〇三ミリメートル未満のZ軸又はW軸を有しないもの
4. Machine tools designed for use as jig grinders that do not have a Z axis or W axis with positioning precision of less than 0.003 millimeters when measured according to the method of measurement specified by International Standard ISO 230-2:1997
- (五) 平面研削盤
5. Flat surface grinders
- ニ 放電加工 (ワイヤ放電加工を除く。) をすることができる工作機械であって、輪郭制御をすることができる回転軸の数が二以上のもの
- (d) Machine tools capable of electrical discharge machining (excluding wire electrical discharge machining) with 2 or more rotational axes capable of controlling contour
- ホ 液体ジェット加工をすることができる工作機械、電子ビーム加工機又はレーザー加工機であって、次の (一) 及び (二) に該当するもの
- (e) Machine tools capable of liquid jet machining, electron beam machines or laser beam machines that fall under any of the following categories 1. or 2.
- (一) 輪郭制御をすることができる回転軸の数が二以上のもの
1. Machine tools or machines with 2 or more rotational axes capable of controlling contour
- (二) 国際規格 I S O 二三〇/二 (一九九七) で定める測定方法により測定したときの回転軸の位置決め精度が〇・〇〇三度未満のもの
2. Machine tools or machines with rotational axis positioning precision of less than 0.003 degrees when measured according to the method of

measurement specified by International Standard ISO 230-2:1997

へ 工作機械であって、次のいずれかを製造するためのみに使用するように設計したもの

(f) Machine tools that were designed exclusively for the manufacture of any of the following

(一) 歯車

1. Gears

(二) クランク軸又はカム軸

2. Crank shafts or cam shafts

(三) 工具又は刃物

3. Tools or blades

(四) 押出機のウォーム

4. Extruder worms

(五) 宝石

5. Gemstones

三 工作機械（金属、セラミック又は複合材料を加工することができるものに限る。）であって、電子制御装置を取り付けることができるもののうち、深穴ボール盤若しくは旋削をすることができるもの（深穴あけをすることができるものに限る。）で、深さが五、〇〇〇ミリメートルを超える穴をあけることができるもの又はこれらの部分品

(iii) Among machine tools (limited to those that can process metals, ceramics or composite materials) to which an electronic controller can be attached and are capable of deep bore drilling or lathe turning (limited to those that are capable of deep bore drilling), those that can bore a hole to a depth exceeding 5,000 millimeters, or components thereof

四 数値制御を行うことができる工作機械であって、磁性流体研磨法を用いるもの

(iv) Machine tools capable of numerical control and that employ magnetic fluid grinding methods

五 日本工業規格 Z 二二四五号（ロックウェル硬さ試験方法）で定める測定方法により C スケールで測定したロックウェル硬さが四〇以上である歯車を仕上げ加工するよう設計した工作機械であって、ピッチ円直径が一、二五〇ミリメートルを超え、かつ、歯幅がピッチ円直径の一五パーセント以上の平歯車、はすば歯車若しくはやまば歯車のうち国際規格 I S O 一三二八（円筒歯車— I S O 方式による精度）で定める精度が三級以上のものを仕上げ加工することができるもの又はその部分品、制御装置若しくは附属品

(v) Machine tools designed for finish processing of gears with a Rockwell hardness of 40 or greater as measured by the C scale according to the measurement methods specified in Japanese Industrial Standard Z2245 (Rockwell hardness testing method), with pitch diameter exceeding 1,250 millimeters and face width with pitch diameter exceeding 15% of spur gears, helical gears, or double-helical gears, that are capable of finish processing

with a precision grade of 3 or higher as specified by International Standard ISO 1328 (ISO system of precision for cylindrical gears) or the components, controllers, or accessories thereof.

六 アイソスタチックプレスであって、次のイ及びロに該当するもの又はその部分品若しくは附属品

(vi) Isostatic presses that fall under any of the following categories (a) and (b), or the components or accessories thereof

イ 内径が四〇六ミリメートル以上の中空室を有するものであって、中空室内の温度制御ができるもの

(a) Isostatic presses having hollow cavities with an internal diameter of 406 millimeters or more and capable of controlling temperature inside the hollow cavities

ロ 次のいずれかに該当するもの

(b) Isostatic presses that fall under any of the following

(一) 最大圧力が二〇七メガパスカルを超えるもの

1. Isostatic presses with a maximum pressure exceeding 207 megapascals

(二) 中空室内の温度を一、五〇〇度を超える温度に制御することができるもの

2. Isostatic presses capable of controlling temperatures exceeding 1,500 degrees centigrade in hollow cavities

(三) 炭化水素の注入のための装置及びガス状分解生成物を除去するための装置を有するもの

3. Isostatic presses that incorporate devices to inject hydrocarbons and devices to remove gaseous decomposition products

七 コーティング装置（半導体物質、半導体素子又は集積回路の製造用に設計したものを除く。）であって、次のいずれかに該当するもの又はその自動操作のための部分品

(vii) Coating devices (excluding those designed for the manufacture of semiconductor materials, semiconductor devices, or integrated circuits) that fall under any of the following, or the components for the automatic operation thereof

イ 原料ガスの化学反応により生成するコーティング材料を基材の表面に定着させる方法を用いるものであって、次の（一）及び（二）に該当するもの

(a) Coating devices that employ methods of fixing to the substrate surface coating materials that are produced by the chemical reaction of source gases, and that fall under any of the following 1. and 2.

(一) 次のいずれかの方法を用いるもの

1. Coating devices that employ any of the following methods

1 パルスの方法

i. Pulse method

2 核生成制御熱化学的析出法



- ii. Controlled nucleation thermochemical deposition method
  - 3 プラズマ放電下においてコーティング材料を基材の表面に定着させる方法
- iii. Methods that fix coating materials to the substrate surface by plasma arc
  - (二) 次のいずれかに該当するもの
- 2. Coating devices that fall under any of the following
  - 1 一〇ミリパスカル以下で使用することができる回転軸シールを組み込んだもの
    - i. Coating devices incorporating rotational axis seals that can be used at 10 millipascals or less
      - 2 膜厚制御機能を内部に有しているもの
    - ii. Coating devices that have internal film thickness control functions
  - ロ イオン注入法を用いるものであって、ビーム電流が五ミリアンペア以上のもの
- (b) Coating devices that employ ion implantation method and with a beam current of 5 milliamperes or more
  - ハ 電子ビームにより蒸発させたコーティング材料を基材の表面に定着させる方法を用いるものであって、容量が八〇キロワットを超える電源装置を組み込んだもののうち、次のいずれかに該当する装置を有するもの
- (c) Among coating devices that employ methods of affixing to the substrate surface coating materials that have been vaporized by electron beams, and that incorporate power supply devices with a capacity exceeding 80 kilowatts, those that have the equipment falling under any of the following
  - (一) インゴットの送りを制御するために、熔融液の液面制御をレーザー光を用いて行う装置
    - 1. Coating devices that effects molten liquid level control by employing laser light to control ingot feeding
      - (二) コンピュータを用いて制御することができる溶着速度の監視装置であって、二以上の元素をコーティングする際の溶着速度を制御するために蒸気流中におけるイオン化原子のホトルミネセンスの原理を利用するもの
    - 2. Deposition rate monitoring devices capable of achieving control by employing computers and that utilize the principle of ionized atom photoluminescence of ionized atoms occurring in vapor flow to control the rate of deposition when coating with two or more elements
  - ニ プラズマ溶射をするものであって、次のいずれかに該当するもの
- (d) Plasma spray coating devices that fall under the following
  - (一) 溶射前に真空室を一〇ミリパスカルまで減圧することができるものであって、一〇キロパスカル以下の圧力（ノズル出口から三〇センチメートル以内において測定したものをいう。）で使用することができるもの
    - 1. Plasma spray coating devices that can reduce pressure in vacuum chambers prior to plasma spraying to 10 millipascals and that can be used at a pressure of 10 kilopascals or less (referring to plasma

spraying within 30 centimeters measured from the mouth of the nozzle)

(二) 膜厚制御機能を内部に有しているもの

**2. Plasma spray coating devices with internal film thickness control function**

ホ スパッタリング法を用いるものであって、毎時一五マイクロメートル以上の溶着速度における電流密度が一〇ミリアンペア毎平方センチメートル以上のもの

(e) Coating devices that use the sputtering method and has a current density of 10 milliamperes per square centimeter or more for hourly deposition rates of 15 micrometers or more

ヘ アーク放電によりイオン化されたコーティング材料を基材の表面に定着させる方法を用いるものであって、陰極上のアークスポットを制御するための磁界を有するもの

(f) Coating devices that employ methods to fix coating materials ionized by arc discharge to the substrate surface and that have a magnetic field to control arc spots on the cathodes

ト イオンプレーティング生産装置であって、コーティング中に次のいずれかを測定することができるもの

(g) Ion plating production equipment that can measure the following characteristics of the coating

(一) 基材の表面に定着したコーティング材料の厚さ及び成膜速度

1. Thickness and deposition rate of coating materials fixed to the substrate surface

(二) 基材の表面の光学的特性

2. The optical properties of the substrate surface

ハ 測定装置（工作機械であって、測定装置として使用することができるものを含む。以下この条において同じ。）であって、次のいずれかに該当するもの

(viii) Measuring devices (including machine tools that can be used as measuring devices; hereinafter the same shall apply in this Article) that fall under any of the following

イ 電子計算機又は数値制御装置によって制御される座標測定機であって、国際規格 I S O 一〇三六〇 / 二 (二〇〇一) (座標計測第二部) で定める測定方法により空間の測定精度を測定した場合に、操作範囲内のいずれかの測定点において、測定軸のマイクロメートルで表した最大許容指示誤差がミリメートルで表した当該測定軸の長さに〇・〇〇一を乗じて得た数値に一・七を加えた数値以下となるもの

(a) Coordinate measuring instruments that are controlled by computer or numerically- controlled coordinate measuring equipment and that, when the precision of measurement of intervals is measured according to the measurement method specified in International Standard ISO 10360-2:2001 for any of the points of measurement within the limits of operation,

have a number of maximum permissible indications of error of the measured axis displayed in micrometers that is equal to or less than the value obtained by multiplying the length of said measured axis in millimeters by 0.001 and then adding 1.7

ロ 光の散乱を角度の関数として処理することにより表面粗さを測定するものであって、 $0.5$  ナノメートル以下の感度を有するもの

(b) Measuring devices that measure surface roughness by treating the angles of the scattering of light as functions and that have a sensitivity of  $0.5$  nanometers or less

九 ロボット（操縦ロボット及びシーケンスロボットを除く。）であって、次のいずれかに該当するもの又はその制御装置若しくはエンドエフェクター

(ix) Robots (excluding operating robots and sequenced robots) that fall under any of the following, or the control equipment or end effectors thereof

イ プログラム又はプログラムの数値データを作成又は書き換えるために、即時に完全三次元の画像処理又は完全三次元の情景解析ができるもの

(a) Robots that are capable of conducting complete instant three-dimensional image processing or complete three-dimensional scene analysis in order to create or rewrite programs or the numeric data of programs.

ロ 日本工業規格 C0930 号で定める防爆構造のもの

(b) Robots of explosion-proof construction as specified in Japanese Industrial Standard C0930

ハ 全吸収線量がシリコン換算で五、 $000$  グレイを超える放射線照射に耐えることができるように設計したもの

(c) Robots designed to withstand a total absorbed atomic radiation dose exceeding  $5,000$  grays on a silicon conversion basis

ニ  $30,000$  メートルを超える高度で使用するよう設計したもの

(d) Devices designed for use at altitudes exceeding  $30,000$  meters

十 測定装置又は工作機械の部分品又は附属装置であって、次のいずれかに該当するもの

(x) Components or auxiliaries for measuring devices of machine tools that fall under any of the following

イ 直線上の位置を検出する位置検出器を有するフィードバック装置であって、当該装置の精度が位置検出器のミリメートルで表したスケールの有効長さの  $10$  万分の六パーセントに  $0.0008$  ミリメートルを加えて得た数値未満のもの

(a) Feedback devices having position detectors that detect position on a straight line in which the precision of said devices possesses a value that is less than the value obtained by adding  $0.0008$  millimeters to  $6\%$  of one hundred thousandth ( $100,000$ th) of the effective length of a position detector scale in millimeters

ロ 角度を検出する位置検出器を有するフィードバック装置であって、当該装置の精度が  $0.00025$  度未満のもの

(b) Feedback devices having position detectors that detect angles in which the precision of said devices is less than 0.00025 degrees

ハ 複合回転テーブル又は加工中に中心線の他の軸に対する角度を変更することができるスピンドルであって、工作機械に取り付けることによって、その機械を第二号から第五号までのいずれかに規定する仕様にする事ができるもの

(c) Compound rotation tables or spindles that can change angles in relation to axes other than the center line axis during processing, and that by being fitted to machine tools make said machine tools fall under any of the specifications prescribed in item (ii) through item (v) inclusive

十一 絞りスピニング加工機又はしごきスピニング加工機であって、次のイ、ロ及びハのすべてに該当するもの

(xi) Spin-forming machines or flow-forming machines that fall under all of the following (a) through (c) inclusive

イ 数値制御装置又は電子計算機によって制御することができるもの

(a) Spin-forming machines or flow-forming machines that are capable of exerting control by numerically - controlled coordinate measuring equipment or computers

ロ 輪郭制御をすることができる軸数が二以上のもの

(b) Spin-forming machines or flow-forming machines with 2 or more axes capable of controlling contour

ハ ローラの加圧力が六〇キロニュートンを超えるもの

(c) Spin-forming machines or flow-forming machines with a roller welding force exceeding 60 kilonewtons

第六条 輸出令別表第一の七の項の経済産業省令で定める仕様のもものは、次のいずれかに該当するものとする。

Article 6 Goods with specifications prescribed by Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 7 of appended table 1 of the Export Order shall fall under any of the following.

一 集積回路であって、次のいずれかに該当するもの

(i) Integrated circuits that fall under any of the following

イ 次のいずれかの放射線照射に耐えられるように設計したもの（他の貨物に使用するように設計したものを除く。）

(a) Integrated circuits designed to withstand any of the following categories of atomic radiation (excluding those designed for use in other goods)

(一) 全吸収線量がシリコン換算で五、〇〇〇グレイ以上のもの

1. Integrated circuits with a total absorbed dose of 5,000 grays or more on a silicon conversion basis

(二) 吸収線量がシリコン換算で一秒間に五、〇〇〇、〇〇〇グレイ以上のもの

2. Integrated circuits with an absorbed dose of 5,000,000 grays or more in

one second on a silicon conversion basis

(三) 一メガ電子ボルト相当の中性子束（積算値）が一平方センチメートル当たり五〇兆個以上となるもの（MIS形のものを除く。）

3. Integrated circuits with a neutron flux corresponding to 1 megaelectron volt (integrated value) of 50 trillion or more per square centimeter (excluding MIS type)

ロ マイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ、マイクロコントローラ、プログラムを電氣的に消去することができるプログラマブルROM（フラッシュメモリーを含む。）、スタティック式のRAM、化合物半導体を用いた記憶素子用のもの、アナログデジタル変換用のもの、デジタルアナログ変換用のもの、信号処理用の電気光学的集積回路若しくは光集積回路、フィールドプログラマブルロジックデバイス、ニューラルネットワークを用いたもの、カスタム集積回路（ハからチまでのいずれか若しくはルに該当する貨物であるかどうかの判断をすることができるもの又は輸出令別表第一の五から一五までの項の中欄のいずれかに該当する貨物に使用するように設計したものであるかどうかの判断をすることができるものを除く。以下この条において同じ。）又はFFTプロセッサであつて、次のいずれかに該当するもの（他の貨物に使用するように設計したものを除く。）

(b) Microprocessors, microcomputers, microcontrollers, programmable ROM that can electronically delete programs (including flash memory), static RAM, and devices using storage elements that employ compound semiconductors, analog-to-digital converters, digital-to-analog converters, electro-optical integrated circuits or optical integrated circuits used for signal processing, field programmable logic devices, those using neural networks, custom integrated circuits (excluding those for which it is possible to determine whether or not they are goods that fall under any of (c) through (h), or (k), or those for which it is possible to determine whether or not they are goods falling under any of the goods in the middle column of rows 5 through 15 of the appended table 1 of the Export Order; hereinafter the same shall apply in this Article) or FFT processors that fall under any of the following categories (excluding those designed for use in other goods)

(一) 一二五度を超える温度で使用することができるように設計したもの

1. Devices designed for use at temperatures exceeding 125 degrees centigrade

(二) 零下五五度未満の温度で使用することができるように設計したもの

2. Devices designed for use at temperatures of less than -55 degrees centigrade

(三) 零下五五度以上一二五度以下のすべての温度範囲で使用することができるように設計したもの

3. Devices designed for use at all temperatures in a range from -55 degrees centigrade or more to 125 degrees centigrade or less

ハ マイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ又はマイクロコントローラであって、次のいずれかに該当するもの（他の貨物に使用するよう設計したものを除く。ただし、シリコンを主材料としたマイクロコンピュータ又はマイクロコントローラであって、オペランドの長さが八ビット以下のものにあつては、他の貨物に使用するよう設計したものを含む。）

(c) Microprocessors, microcomputers or microcontrollers that fall under any of the following (excluding those designed for use in other goods; however microcomputers or microcontrollers using silicon as their principal material designed for use in other goods or devices with an operand length of 8 bits or less are included)

(一) 削除

1. Deleted

(二) 化合物半導体を用いたものであつて、最大クロック周波数が四〇メガヘルツを超えるもの

2. Devices employing compound semiconductors with a maximum clock frequency exceeding 40 megahertz

(三) 一、〇〇〇メガバイト毎秒を超える転送速度で並列マイクロプロセッサ間を直接外部接続するデータバス、命令バス又は直列通信ポートのいずれかを四以上有するもの

3. Devices having 4 or more of any of data busses, instruction busses or serial communication ports that directly connect parallel microprocessors externally at transfer speeds exceeding 1,000 megabytes per second

ニ 化合物半導体を用いた記憶素子用のもの（他の貨物に使用するよう設計したものを除く。）

(d) Devices used for storage elements employing compound semiconductors (excluding those designed for use in other goods)

ホ アナログデジタル変換用のもの又はデジタルアナログ変換用のものであつて、次のいずれかに該当するもの（他の貨物に使用するよう設計したものを除く。）

(e) Devices used for analog-to-digital conversion or digital-to-analog conversion that fall under any of the following (excluding those designed for use in other goods)

(一) アナログデジタル変換用のものであつて、次のいずれかに該当するもの

1. Devices used for analog-to-digital conversion that fall under any of the following

1 分解能が八ビット以上一〇ビット未満のものであつて、出力速度が五〇〇メガサンプリング毎秒を超えるもの

i. Devices with 8 bits to less than 10 bits resolution with an output rate exceeding 500 mega sampling per second

2 分解能が一〇ビット以上一二ビット未満のものであつて、出力速度が二〇

- メガサンプリング毎秒を超えるもの
- ii. Devices with 10 bits or more to less than 12 bits resolution with an output rate exceeding 200 mega sampling per second
  - 3 分解能が一ニビットのものであって、出力速度が五〇メガサンプリング毎秒を超えるもの
- iii. Devices with 12 bits resolution with an output rate exceeding 50 mega sampling per second
  - 4 分解能が一ニビット超一四ビット以下のものであって、出力速度が五メガサンプリング毎秒を超えるもの
- iv. Devices with resolution exceeding 12 bits and less than 14 bits, with an output rate exceeding 5 mega sampling per second
  - 5 分解能が一四ビットを超えるものであって、出力速度が一メガサンプリング毎秒を超えるもの
- v. Devices with resolution exceeding 14 bits, with an output rate exceeding 1 mega sampling per second
  - (二) デジタルアナログ変換用のものであって、分解能が一ニビット以上のもののうち、セトリング時間が一〇ナノ秒未満のもの
- 2. Among devices used for digital-to-analog conversion with 12 bits or more resolution, those with settling times of less than 10 nanoseconds
- へ 信号処理用の電気光学的集積回路又は光集積回路であって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの(他の貨物に使用するよう設計したものを除く。)
- (f) Electro-optical integrated circuits or optical integrated circuits used for signal processing that fall under all of the following 1. through 3. (excluding those designed for use in other goods)
  - (一) レーザー発振器を有するもの
  - 1. Integrated circuits possessing laser oscillators
    - (二) 受光素子を有するもの
  - 2. Integrated circuits possessing photo-detectors
    - (三) 光導波路を有するもの
  - 3. Integrated circuits possessing optical waveguides
- ト フィールドプログラマブルロジックデバイスであって、次のいずれかに該当するもの(他の貨物に使用するよう設計したものを除く。)
- (g) Field programmable logic devices that fall under any of the following (excluding those designed for use in other goods)
  - (一) 使用することができるゲート数が二入力ゲート換算で三〇、〇〇〇を超えるよう設計したもの
  - 1. Devices designed so that the number of usable gates exceeds 30,000 on a dual-entry gate conversion basis
    - (二) 基本ゲート伝搬遅延時間が〇・一ナノ秒未満のもの
  - 2. Devices with a basic gate propagation delay time of less than 0.1

nanoseconds

(三) トグル周波数が一三三メガヘルツを超えるもの

**3. Devices with a toggle frequency exceeding 133 megahertz**

チ ニューラルネットワークを用いたもの（他の貨物に使用するように設計したものを除く。）

**(h) Devices employing neural networks (excluding those designed for use in other goods)**

リ カスタム集積回路であって、次のいずれかに該当するもの

**(i) Custom integrated circuits that fall under any of the following**

(一) 端子数が一、〇〇〇を超えるもの

**1. Custom integrated circuits with terminals exceeding 1,000**

(二) 基本ゲート伝搬遅延時間が〇・一ナノ秒未満のもの

**2. Custom integrated circuits with a basic gate propagation delay time of less than 0.1 nanoseconds**

(三) 動作周波数が三ギガヘルツを超えるもの

**3. Custom integrated circuits with an operating frequency exceeding 3 gigahertz**

ヌ 化合物半導体を用いたデジタル方式のものであって、次のいずれかに該当するもの（マイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ、マイクロコントローラ、化合物半導体を用いた記憶素子用のもの、アナログデジタル変換用のもの、デジタルアナログ変換用のもの、信号処理用の電気光学的集積回路又は光集積回路、フィールドプログラマブルロジックデバイス、ニューラルネットワークを用いたもの、カスタム集積回路、FFTプロセッサ及び他の貨物に使用するように設計したものを除く。）

**(j) Digital devices employing compound semiconductors that fall under any of the following (excluding those used for storage elements employing compound semiconductors, analog-to-digital converters, digital-to-analog converters, electro-optical integrated circuits or optical integrated circuits used for signal processing, field programmable logic devices, devices using neural networks, custom integrated circuits, FFT processors and those designed for use in other goods)**

(一) 等価ゲート数が二入力ゲート換算で三、〇〇〇を超えるもの

**1. Digital devices with a number of equivalent gates exceeding 3,000 on a dual-entry gate conversion basis**

(二) トグル周波数が一・二ギガヘルツを超えるもの

**2. Digital devices with a toggle frequency exceeding 1.2 gigahertz**

ル FFTプロセッサであって、高速フーリエ変換のミリ秒で表した定格実行時間が次に掲げる式により算出した値未満のもの（他の貨物に使用するように設計したものを除く。）

**(k) FFT processors (excluding those designed for use in other goods) with a Fast Fourier Transformation rated execution time expressed in**



milliseconds that is less than the value calculated by the following formula  
{ (number of complex points)  $\log_2$  (number of complex points) }  $\div$  20,480  
{(number of complex points)  $\log_2$  (number of complex points)} divided by  
20,480

二 マイクロ波用機器又はミリ波用機器の部分品であつて、次のいずれかに該当するもの（他の貨物に使用するように設計したものを除く。）

(ii) Components of devices using microwaves or millimeter waves that fall under any of the following (excluding those designed for use in other goods)

イ 電子管であつて、次の（一）又は（二）に該当するもの（（三）に該当するものを除く。）

(a) Electron tubes that fall under the following 1. or 2. (excluding those that fall under 3. following)

（一） 進行波管であつて、次のいずれかに該当するもの

1. Traveling wave tubes that fall under any of the following

1 動作周波数が三・八ギガヘルツを超えるもの

i. Traveling wave tubes with an operating frequency exceeding 31.8 gigahertz

2 フィラメントを加熱してから定格出力に達するまでの時間が三秒未満の熱陰極を有するもの

ii. Traveling wave tubes having a hot cathode for which the time from the heating of the filament to attainment of the rated output is less than 3 seconds

3 空洞結合形のものであつて、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が七パーセントを超えるもの又は最大出力が二・五キロワットを超えるもの

iii. Traveling wave tubes with cavity coupling in which the value for the instantaneous bandwidth divided by the center frequency exceeds 7% or a maximum output exceeding 2.5 kilowatts

4 ヘリックス形のものであつて、次のいずれかに該当するもの

iv. Traveling wave tubes with helical form that fall under any of the following

一 一オクターブを超える瞬時帯域幅を有するものであつて、キロワットで表した場合の平均出力の数値にギガヘルツで表した場合の動作周波数の数値を乗じて得た数値が〇・五を超えるもの

a. Devices having an instantaneous bandwidth exceeding 1 octave, and for which the value obtained by multiplying the average output value expressed in kilowatts by the operating frequency value expressed in gigahertz exceeds 0.5

二 一オクターブ以下の瞬時帯域幅を有するものであつて、キロワットで表した場合の平均出力の数値にギガヘルツで表した場合の動作周波数の数値を乗じて得た数値が一を超えるもの

b. Devices having an instantaneous bandwidth of 1 octave or less, and for

which the value obtained by multiplying the average output value expressed in kilowatts by the operating frequency value expressed in gigahertz exceeds 1

三 宇宙用に設計したもの

c. Devices designed for space use

(二) クロスフィールド増幅管であって、その利得が一七デシベルを超えるもの

2. Crossfield amplifier tubes with a gain exceeding 17 decibels

(三) 国際電気通信連合が無線通信用に割り当てた周波数帯域（無線測位用に割り当てた周波数帯域を除く。）で使用するよう設計したものであって、次のいずれかに該当するもの

3. Devices designed to use frequency bands allotted for wireless transmission by the International Telecommunication Union (excluding frequency bands allotted for wireless radio determination) that fall under any of the following

1 動作周波数が三・八ギガヘルツ以下であるもの

i. Devices with an operating frequency of 31.8 gigahertz or less

2 専ら宇宙において使用するために設計したもの以外のものであって、平均出力値が五〇ワット以下及び動作周波数が三・八ギガヘルツ超四三・五ギガヘルツ以下のもの

ii. Devices other than those designed exclusively for use in space that have an average output of 50 watts or less and an operating frequency exceeding 31.8 gigahertz and 43.5 gigahertz or less

ロ 電子管に使用するよう設計した含浸形陰極であって、定格動作状態での連続放射電流密度が五アンペア毎平方センチメートルを超えるもの

(b) Impregnated cathodes designed for use in electron tubes with continuous emission current density under rated operating conditions exceeding 5 amperes per square centimeter

ハ マイクロ波用モノリシック集積回路電力増幅器であって、次のいずれかに該当するもの（四〇・五ギガヘルツ以上四二・五ギガヘルツ以下の動作周波数で使用するよう設計した衛星放送用のものを除く。）

(c) Monolithic microwave integrated circuit power amplifiers that fall under any of the following (excluding those used for broadcasting satellites designed for use at an operating frequency of 40.5 gigahertz or more and 42.5 gigahertz or less)

(一) 動作周波数が三・二ギガヘルツ超六ギガヘルツ以下であって、平均出力値が四ワット（三六ディービーエム）を超えるもののうち、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が一五パーセントを超えるもの

1. Among devices with an operating frequency exceeding 3.2 gigahertz and 6 gigahertz or less with an average output value exceeding 4 watts (36 dBm), those for which the value of the instantaneous bandwidth

divided by the center frequency exceeds 15%

- (二) 動作周波数が六ギガヘルツ超一六ギガヘルツ以下であって、平均出力値が一ワット（三〇ディービーエム）を超えるもののうち、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が一〇パーセントを超えるもの

2. Among devices with an operating frequency exceeding 6 gigahertz and 16 gigahertz or less with an average output value exceeding 1 watt (30 dBm), those for which the value of the instantaneous bandwidth divided by the center frequency exceeds 10%

- (三) 動作周波数が一六ギガヘルツ超三・八ギガヘルツ以下であって、平均出力値が〇・八ワット（二九ディービーエム）を超えるもののうち、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が一〇パーセントを超えるもの

3. Among devices with an operating frequency exceeding 16 gigahertz and 31.8 gigahertz or less with an average output value exceeding 0.8 watts (29 dBm), those for which the value of the instantaneous bandwidth divided by the center frequency exceeds 10%

- (四) 動作周波数が三・八ギガヘルツ超三七・五ギガヘルツ以下のもの

4. Devices with an operating frequency exceeding 31.8 gigahertz and 37.5 gigahertz or less

- (五) 動作周波数が三七・五ギガヘルツ超四三・五ギガヘルツ以下であって、平均出力値が〇・二五ワット（二四ディービーエム）を超えるもののうち、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が一〇パーセントを超えるもの

5. Among devices with an operating frequency exceeding 37.5 gigahertz and 43.5 gigahertz or less and with an average output value exceeding 0.25 watts (24 dBm), those for which the value of the instantaneous bandwidth divided by the center frequency exceeds 10%

- (六) 動作周波数が四三・五ギガヘルツを超えるもの

6. Devices with an operating frequency exceeding 43.5 gigahertz

ニ マイクロ波用トランジスタであって、次のいずれかに該当するもの

(d) Microwave transistors that fall under any of the following

- (一) 動作周波数が三・二ギガヘルツ超六ギガヘルツ以下であって、平均出力値が六〇ワット（四七・八ディービーエム）を超えるもの

1. Devices with an operating frequency exceeding 3.2 gigahertz and 6 gigahertz or less and with an average output value exceeding 60 watts (47.8 dBm)

- (二) 動作周波数が六ギガヘルツ超三・八ギガヘルツ以下であって、平均出力値が二〇ワット（四三ディービーエム）を超えるもの

2. Devices with an operating frequency exceeding 6 gigahertz and 31.8 gigahertz or less, and an average output value exceeding 20 watts (43 dBm)

- (三) 動作周波数が三・八ギガヘルツ超三七・五ギガヘルツ以下であって、平均出力値が〇・五ワット（二七ディービーエム）を超えるもの

3. Devices with an operating frequency exceeding 31.8 gigahertz and 37.5 gigahertz or less and with an average output value exceeding 0.5 watts (27 dBm)
  - (四) 動作周波数が三七・五ギガヘルツ超四三・五ギガヘルツ以下であって、平均出力値が一ワット（三〇ディービーエム）を超えるもの
4. Devices with an operating frequency exceeding 37.5 gigahertz and 43.5 gigahertz or less and with an average output value exceeding 1 watt (30 dBm)
  - (五) 動作周波数が四三・五ギガヘルツを超えるもの
5. Devices with an operating frequency exceeding 43.5 gigahertz
 

ホ マイクロ波用固体増幅器又はマイクロ波用増幅器を含む組立品若しくはモジュールであって、次のいずれかに該当するもの（マイクロ波用モノリシック集積回路電力増幅器又は四〇・五ギガヘルツ以上四二・五ギガヘルツ以下の動作周波数で使用するよう設計した衛星放送用のものを除く。）
- (e) Solid-state microwave amplifiers or assemblies or modules containing microwave amplifiers that fall under any of the following (excluding microwave monolithic integrated circuit power amplifiers or devices designed for satellite broadcast use at an operating frequency of 40.5 gigahertz or higher to 42.5 gigahertz or less)
  - (一) 動作周波数が三・二ギガヘルツ超六ギガヘルツ以下であって、平均出力値が六〇ワット（四七・八ディービーエム）を超えるもののうち、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が一五パーセントを超えるもの
  1. Among devices with an operating frequency exceeding 3.2 gigahertz and 6 gigahertz or less and with an average output value exceeding 60 watts (47.8 dBm), those for which the value of the instantaneous bandwidth divided by the center frequency exceeds 15%
    - (二) 動作周波数が六ギガヘルツ超三一・八ギガヘルツ以下であって、平均出力値が一五ワット（四二ディービーエム）を超えるもののうち、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が一〇パーセントを超えるもの
  2. Among devices with an operating frequency exceeding 6 gigahertz and 31.8 gigahertz or less and with an average output value exceeding 15 watts (42 dBm), those for which the value of the instantaneous bandwidth divided by the center frequency exceeds 10%
    - (三) 動作周波数が三一・八ギガヘルツ超三七・五ギガヘルツ以下のもの
  3. Devices with an operating frequency exceeding 31.8 gigahertz and 37.5 gigahertz or less
    - (四) 動作周波数が三七・五ギガヘルツ超四三・五ギガヘルツ以下であって、平均出力値が一ワット（三〇ディービーエム）を超えるもののうち、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が一〇パーセントを超えるもの
  4. Among devices with an operating frequency exceeding 37.5 gigahertz and 43.5 gigahertz or less and with an average output value exceeding

- 1 watt (30 dBm), those for which the value of the instantaneous bandwidth divided by the center frequency exceeds 10%
- (五) 動作周波数が四三・五ギガヘルツを超えるもの
5. Devices with an operating frequency exceeding 43.5 gigahertz
- (六) 動作周波数が三ギガヘルツを超えるものであって、次の1から3までのすべてに該当するもの
6. Devices with an operating frequency exceeding 3 gigahertz that fall under all of the following categories i. to iii.
- 1 ワットで表した平均出力値にギガヘルツで表した最大動作周波数の二乗を乗じた値が一五〇を超えるもの
- i. Devices for which the value of the average output value expressed in watts multiplied by the maximum operating frequency expressed in gigahertz squared exceeds 150
- 2 瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が五パーセント以上のもの
- ii. Devices for which the value of the instantaneous bandwidth divided by the center frequency is 5% or more
- 3 アレー状に配列された増幅器又は組立品、モジュールの垂直に隣り合った距離をセンチメートルで表した値にギガヘルツで表した最小動作周波数を乗じた値が一五以下のもの
- iii. Devices for which the value of the distance of vertically adjacent amplifiers or assemblies, or modules in array alignment expressed in centimeters multiplied by the minimum operating frequency expressed in gigahertz is 15 or less
- へ 電子的又は磁氣的に同調可能な帯域通過フィルターであって、次の(一)及び(二)に該当するもの
- (f) Electronically or magnetically tunable band-pass filters that fall under the following 1. and 2.
- (一) 半オクターブの周波数帯域を一〇マイクロ秒未満で同調可能な可変周波数共振器を六以上有するもの
1. Devices having 6 or more variable frequency resonators capable of tuning across a half-octave frequency band in less than 10 microseconds
- (二) 中心周波数の〇・五パーセントを超える帯域を通過することができるもの
2. Devices capable of band-passing in excess of 0.5% of the center frequency
- ト 電子的又は磁氣的に同調可能な帯域阻止フィルターであって、次の(一)及び(二)に該当するもの
- (g) Electronically or magnetically tunable band-elimination filters that fall under the following 1. and 2.
- (一) 半オクターブの周波数帯域を一〇マイクロ秒未満で同調可能な可変周波数共振器を六以上有するもの

1. Devices having 6 or more variable frequency resonators capable of tuning across a half-octave frequency band in less than 10 microseconds

(二) 中心周波数の〇・五パーセント未満の帯域を阻止することができるもの

2. Devices capable of eliminating a band less than 0.5% of the center frequency

チ 削除

(h) Deleted

リ ミキサ又はコンバータであって、周波数分析器、ネットワークアナライザ又はマイクロ波用試験受信機に使用することによって、これらの装置を第十二号イ若しくはロ、第十四号又は第十五号イのいずれかに該当するように設計したもの

(i) Mixers or converters designed so that by their use in frequency analyzers, network analyzers or microwave test receivers, said equipment falls under any of item (xii), (a) or (b), item (xiv) or item (xv), (a)

ヌ イに該当する電子管を内蔵するマイクロ波用電力増幅器であって、次の(一)及び(二)に該当するもの(国際電気通信連合が無線通信用に割り当てた周波数帯域(無線測位用に割り当てた周波数帯域を除く。)で使用するように設計したものを除く。)

(j) Microwave power amplifiers equipped with electron tubes that fall under (a), and that fall under the following categories 1. and 2. (excluding equipment used on frequency bands allotted for wireless transmission by the International Telecommunication Union (excluding frequency bands allotted for wireless radio determination))

(一) 動作周波数が三ギガヘルツを超えるもの

1. Devices with an operating frequency exceeding 3 gigahertz

(二) 平均出力電力密度が八〇ワット毎キログラムを超えるものであって、体積が四〇〇立方センチメートル未満のもの

2. Devices with average output power density exceeding 80 watts per kilogram and with a volume of less than 400 cubic centimeters

三 弾性波若しくは音響光学効果を利用する信号処理装置であって、次のいずれかに該当するもの(他の貨物に使用するように設計したものを除く。)又はその部分品

(iii) Signal processing equipment utilizing elastic waves or acousto-optic effects that fall under any of the following (excluding those designed for use in other goods), or the components thereof

イ 表面弾性波又は疑似表面弾性波を利用するものであって、次のいずれかに該当するもの

(a) Signal processing equipment using surface elastic waves or pseudo-surface elastic waves that fall under any of the following

(一) 搬送周波数が二・五ギガヘルツを超えるもの

1. Signal processing equipment with a carrier frequency exceeding 2.5 gigahertz

- (二) 搬送周波数が一ギガヘルツ超二・五ギガヘルツ以下のものであって、次のいずれかに該当するもの
2. Signal processing equipment with a carrier frequency exceeding 1 gigahertz and 2.5 gigahertz or less that falls under any of the following
- 1 サイドローブに対するメインローブの電力の比が五五デシベルを超えるもの
    - i. Signal processing equipment with a main lobe to side lobe power ratio exceeding 55 decibels
      - 2 マイクロ秒で表した場合の最大遅延時間の数値にメガヘルツで表した場合の帯域幅の数値を乗じて得た数値が一〇〇を超えるもの
    - ii. Signal processing equipment for which the numeric value of the maximum delay time expressed in microseconds multiplied by the value of the bandwidth expressed in megahertz exceeds 100
      - 3 帯域幅が二五〇メガヘルツを超えるもの
    - iii. Signal processing equipment with a bandwidth exceeding 250 megahertz
      - 4 分散型遅延時間（周波数に応じた遅延時間の最大の値と最小の値との差をいう。）が一〇マイクロ秒を超えるもの
    - iv. Signal processing equipment for which the distributed delay time (this refers to the difference between the maximum and minimum delay time values for a frequency) exceeds 10 microseconds
- (三) 搬送周波数が一ギガヘルツ以下のものであって、次のいずれかに該当するもの
3. Signal processing equipment with a carrier frequency of 1 gigahertz or less that falls under any of the following
- 1 マイクロ秒で表した場合の最大遅延時間の数値にメガヘルツで表した場合の帯域幅の数値を乗じて得た数値が一〇〇を超えるもの
    - i. Signal processing equipment for which the numeric value obtained by multiplying the maximum delay time expressed in microseconds by the value of the bandwidth expressed in megahertz exceeds 100
      - 2 分散型遅延時間が一〇マイクロ秒を超えるもの
    - ii. Signal processing equipment for which the distributed delay time exceeds 10 microseconds
      - 3 サイドローブに対するメインローブの電力の比が五五デシベルを超えるものであって、帯域幅が五〇メガヘルツを超えるもの
    - iii. Signal processing equipment with a main lobe to side lobe power ratio exceeding 55 decibels and with a bandwidth exceeding 50 megahertz
- ロ バルク弾性波を利用するものであって、一ギガヘルツを超える周波数で信号の直接処理ができるもの
- (b) Signal processing equipment that utilizes bulk elastic waves and that is capable of performing direct signal processing at frequencies exceeding 1

gigahertz

ハ 弾性波と光波の相互作用を利用したものであって、信号又は画像の直接処理ができるもの

(c) Signal processing that utilizes the interaction of elastic waves and light waves and that is capable of performing direct signal or image processing

四 超電導材料を用いた装置のうち、超電導材料を用いた部品を有する電子素子又は電子回路であって、使用する超電導材料の臨界温度より低い温度で使用することができるように設計し、かつ、次のいずれかに該当するもの（他の貨物に使用するよう設計したものを除く。）

(iv) Among devices using superconductive material that are electron devices or electronic circuits with components using superconductive materials, those designed for use at temperatures lower than the critical temperature of the superconductive materials used and that fall under any of the following (excluding those designed for use in other goods)

イ 超電導ゲートを有するデジタル回路用の電流スイッチングの機能を有するものであって、ゲート当たりの遅延時間にゲート当たりの電力消費を乗じて得た値が一、〇〇〇億分の一ミリジュール未満のもの

(a) Devices possessing a current switching function for use in digital circuits with superconducting gates for which the value obtained by multiplying the delay time per gate by the power consumption per gate is less than 1/100 billion milijoules

ロ 周波数分離の機能を有するものであって、キュー値が一〇、〇〇〇を超える共振回路を有するもの

(b) Devices having frequency separation function and having resonant circuits with a cue value exceeding 10,000

五 電池であって、次のいずれかに該当するもの（単二形電池の体積以下の体積を有するもの及び他の貨物に使用するよう設計したものを除く。）

(v) Batteries that fall under any of the following (excluding batteries with the volume of a size C battery or less and those designed for use in other goods)

イ 一次電池であって、零下三〇度より低い温度から七〇度を超える温度まで使用することができるように設計したもののうち、電圧が放電を開始する直前の電圧の七五パーセントになるまで放電を行った場合におけるエネルギー密度が四八〇ワット時毎キログラムを超えるもの

(a) Among primary batteries designed to be used at temperatures from below -30 degrees centigrade to more than 70 degrees centigrade, those with an energy density exceeding 480 watts hours per kilogram when the voltage is discharged to 75% of the voltage immediately prior to the start of discharge.

ロ 二次電池であって、五時間率電流での放電及び充電を七五回繰り返した後、電圧が放電を開始する直前の電圧の七五パーセントになるまで五時間率放電電流で放電を行った場合におけるエネルギー密度が零下二〇度以上六〇度以下のすべての温度範囲において一五〇ワット時毎キログラムを超えるもの



(b) Secondary batteries, that when the voltage is discharged to 75% of the voltage immediately prior to the start of discharge at a 5-hour discharge current rate, after 75 charge/discharge cycles at a 5-hour discharge current rate, has an energy density exceeding 150 watts hours per kilogram at all temperatures in a range from -20 degrees centigrade or more to 60 degrees centigrade or less

ハ 放射線による影響を防止するように設計した宇宙用の太陽電池であって、二、五二七度のタングステン光源から一キロワット毎平方メートルの照射を受けたときの出力が、二八度の動作温度において一六〇ワット毎平方メートルを超えるもの

(c) Solar cells for space use that are designed to resist radiation, and with an output exceeding 160 watts per square meter at an operating temperature of 28 degrees centigrade when illuminated to the extent of 1 kilowatt per square meter by a tungsten light source at 2,527 kelvins

六 高電圧用のコンデンサであって、次のいずれかに該当するもの（他の貨物に使用するように設計したものを除く。）

(vi) High voltage capacitors that fall under any of the following (excluding those designed for use in other goods)

イ 反復サイクルが一〇ヘルツ未満のコンデンサであって、次の（一）から（三）までのすべてに該当するもの

(a) Capacitors with a repeated cycle of less than 10 hertz that fall under all of the following categories 1. to 3.

（一） 定格電圧が五キロボルト以上のもの

1. Capacitors with a rated voltage of 5 kilovolts or more

（二） エネルギー密度が二五〇ジュール毎キログラム以上のもの

2. Capacitors with an energy density of 250 joules per kilogram or more

（三） 総エネルギーが二五キロジュール以上のもの

3. Capacitors with a total energy of 25 kilojoules or more

ロ 反復サイクルが一〇ヘルツ以上のコンデンサであって、次の（一）から（四）までのすべてに該当するもの

(b) Capacitors with a repetitive cycle of 10 hertz or more and that fall under all of the following categories 1. to 4.

（一） 定格電圧が五キロボルト以上のもの

1. Capacitors with a rated voltage of 5 kilovolts or more

（二） エネルギー密度が五〇ジュール毎キログラム以上のもの

2. Capacitors with an energy density of 50 joules per kilogram or more

（三） 総エネルギーが一〇〇ジュール以上のもの

3. Capacitors with a total energy of 100 joules or more

（四） 一〇、〇〇〇回以上充電及び放電の繰り返しをすることができるように設計したもの

4. Capacitors designed for a charge/discharge cycle life equal to or more

than 10,000 cycles

七 一秒を要しないで磁界を完全に形成させ、又は消失させるように設計した超電導電磁石（ソレノイドコイル形のものを含む。）であって、次のイからハまでのすべてに該当するもの（他の貨物に使用するように設計したものを除く。）

(vii) Superconducting magnets (including solenoid coil types) designed to fully generate or dissipate a complete magnetic field in less than one second that fall under all of the following categories (a) to (c) (excluding those designed for use in other goods)

イ 減磁の際に最初の一秒間で放出するエネルギーが一〇キロジュールを超えるもの

(a) Superconducting magnets that discharge energy exceeding 10 kilojoules in the first second of demagnetization

ロ コイルの内径が二五〇ミリメートルを超えるもの

(b) Superconducting magnets with a coil internal diameter exceeding 250 millimeters

ハ 定格最大電流密度が三〇〇アンペア毎平方ミリメートルを超えるもの又は定格磁束密度が八テスラを超えるもの

(c) Superconducting magnets with a rated maximum current density exceeding 300 amperes per square millimeter or with a rated magnetic flux density exceeding 8 teslas

八 回転入力型のアブソリュートエンコーダであって、次のいずれかに該当するもの（他の貨物に使用するように設計したものを除く。）

(viii) Rotary input type absolute encoders that fall under any of the following (excluding those designed for use in other goods)

イ 分解能が計ることができる最大の角度の二六五、〇〇〇分の一未満のもの

(a) Rotary input type absolute encoders with a resolution of less than 1/265,000 of measurable maximum scale

ロ 角度の変換誤差の絶対値が、二・五秒未満のもの

(b) Rotary input type absolute encoders with an angle conversion error absolute value of less than 2.5 seconds

九 デジタル方式のビデオ磁気テープ記録装置、計測用の磁気テープ記録装置若しくはデジタル方式のビデオ磁気テープ記録装置を計測用の磁気テープ記録装置として使用するための装置であって、次のいずれかに該当するもの（他の貨物に使用するように設計したものを除く。）又はこれらの試験用の磁気テープ

(ix) Digital video magnetic tape recorders, digital instrumentation magnetic tape data recorders or equipment designed to convert digital video magnetic tape recorders for use as digital instrumentation magnetic tape data recorders, that fall under any of the following (excluding those designed for use in other goods), or magnetic tapes used for the testing of these recorders and equipment

イ 計測用のアナログ磁気テープ記録装置であって、次のいずれかに該当するもの

(a) Analog instrumentation magnetic tape recorders that fall under any of the following

(一) 帯域幅が四メガヘルツを超えるトラック又は電子チャンネルを有するもの

1. Analog instrumentation magnetic tape recorders having tracks or electronic channels with a bandwidth exceeding 4 megahertz

(二) 一トラック又は一電子チャンネル当たりの帯域幅が二メガヘルツを超えるものであって、記録トラックの数が四二を超えるもの

2. Analog instrumentation magnetic tape recorders for which bandwidth per one track or one electronic channel exceeds 2 megahertz, and which has recording tracks exceeding 42

(三) タイムベースエラーがプラスマイナス〇・一マイクロ秒未満のもの

3. Analog instrumentation magnetic tape recorders with a time base error of less than plus/minus 0.1 microseconds

ロ デジタル方式のビデオ磁気テープ記録装置（テレビジョン信号の記録用に設計したものであって、国際電気通信連合、国際電気標準会議、アメリカ映画・テレビ技術者協会、ヨーロッパ放送連合又はアメリカ電気電子技術者協会により規格化され、又は勧告された信号フォーマット（圧縮されたものを含む。）を用いたものを除く。）であって、装置間の最大デジタル転送速度が三六〇メガビット毎秒を超えるもの

(b) Digital video magnetic tape recorders (excluding devices designed for recording television signals and that use signal formats (including compressed data) that have been standardized or recommended by the International Telecommunication Union, the International Electrotechnical Commission, the U.S. Society of Motion Picture and Television Engineers, the European Broadcasting Union or the US Institute of Electrical and Electronics Engineers) and that have a maximum digital transfer speed between devices exceeding 360 megabits per second

ハ 計測用のデジタル磁気テープ記録装置であって、ヘリカル走査技術又は固定ヘッド技術を用いたもののうち、次のいずれかに該当するもの

(c) Among digital instrumentation magnetic tape data recorders that employ helical scanning technology or fixed head technology, those that fall under any of the following

(一) 装置間の最大デジタル転送速度が一七五メガビット毎秒を超えるもの

1. Digital instrumentation magnetic tape data recorders with a maximum digital transfer speed between devices exceeding 175 megabits per second

(二) 宇宙用に設計したもの

2. Digital instrumentation magnetic tape data recorders designed for space use

ニ デジタル方式のビデオ磁気テープ記録装置を変換して計測用のデジタル磁気テ

- ープ記録装置として使用することができるように変換する電子装置であって、装置間の最大デジタル転送速度が一七五メガビット毎秒を超えるもの
- (d) Electronic conversion equipment that can convert digital video magnetic tape recorders for use as digital instrumentation magnetic tape data recorders, for which the maximum digital transfer speed between devices exceeds 175 megabits per second
- 十 波形記憶装置であって、次のイ及びロに該当するもの（他の貨物に使用するように設計したものを除く。）
- (x) Waveform digitizers and transient recorders that fall under the following categories (a) and (b) (excluding those designed for use in other goods)
- イ サンプルング速度が一秒当たり二億サンプル以上で、かつ、分解能が一〇ビット以上のもの
- (a) Waveform digitizers and transient recorders with a sample rate of 200 million samples per second or more and with a resolution of 10 bits or more
- ロ 二ギガビット毎秒以上のデータを連続して出力することができるように設計したもの
- (b) Waveform digitizers and transient recorders designed to continuously output data at 2 gigabits per second or more
- 十の二 磁気ディスク記録技術を用いたデジタル方式の計測用記録装置であって、次のイ及びロに該当するもの（他の貨物に使用するように設計したものを除く。）
- (x)-2 Digital instrumentation recorders using magnetic disk storage technology that fall under the following categories (a) and (b) (excluding those designed for use in other goods)
- イ サンプルング速度が一秒当たり一億サンプル以上で、かつ、分解能が八ビット以上のもの
- (a) Digital instrumentation recorders with a sampling rate of 100 million samples per second or more, and a resolution of 8 bits or more
- ロ 一ギガビット毎秒以上のデータを連続して出力することができるように設計したもの
- (b) Digital instrumentation recorders designed to continuously output data at 1 gigabit per second or more
- 十一 装置の部分品であって、周波数シンセサイザーを用いた組立品のうち、周波数切換え所要時間が一ミリ秒未満のもの（他の貨物に使用するように設計したものを除く。）
- (xi) Equipment components that are assemblies employing frequency synthesizers and for which the required time for frequency cycling is less than 1 millisecond (excluding those designed for use in other goods)
- 十二 無線周波数分析器であって、次のいずれかに該当するもの（他の貨物に使用するように設計したものを除く。）
- (xii) Wireless frequency analyzers that fall under any of the following (excluding those designed for use in other goods)

イ 無線周波数分析器であって、三一・八ギガヘルツ超三七・五ギガヘルツ以下の周波数を分析することができ、三デシベルの分解能帯域幅が一〇メガヘルツを超えるもの

(a) Wireless frequency analyzers capable of analyzing frequencies exceeding 31.8 gigahertz and 37.5 gigahertz or less and for which the resolution bandwidth for 3 decibels exceeds 10 megahertz

ロ 無線周波数分析器であって、四十三・五ギガヘルツを超える周波数を分析することができるもの

(b) Wireless frequency analyzers capable of analyzing frequencies exceeding 43.5 gigahertz

ハ デジタル信号処理技術を用いるもの（中心周波数と帯域幅の比が一定であるフィルターのみを使用しているものを除く。）であって、実時間帯域幅が五〇〇キロヘルツを超えるもの

(c) Wireless frequency analyzers employing digital signal processing technology (excluding devices that only use a filter with a constant ratio between center frequency and bandwidth) with real time bandwidth exceeding 500 kilohertz

十三 周波数シンセサイザーを用いた信号発生器のうち、合成出力周波数の精度及び安定度が入力周波数又は当該装置の基準周波数によって規定されるものであって、次のいずれかに該当するもの（周波数シンセサイザーを用いた信号発生器であって、二以上の水晶発振器の周波数を加算した値、減算した値又はこれらの値を逡倍した値によって出力周波数を規定する装置及び他の貨物に使用するよう設計したものを除く。）

(xiii) Among signal generators employing frequency synthesizers, those for which the precision and stability of combined output frequency devices are regulated by the input frequency or the said devices' standard frequency and that fall under any of the following (excluding signal generators employing frequency synthesizers designed for use in equipment and other goods that regulate the output frequency by the value obtained by adding or subtracting the frequencies of 2 or more quartz crystal oscillators or by the value obtained by multiplying these values)

イ 最大合成出力周波数が三一・八ギガヘルツ超四三・五ギガヘルツ以下であって、一〇〇ナノ秒未満のパルス幅のパルスを発振するもの

(a) Signal generators with a maximum combined output frequency exceeding 31.8 gigahertz and 43.5 gigahertz or less, and that oscillate pulse with a pulse width of less than 100 nanoseconds

ロ 最大合成出力周波数が四三・五ギガヘルツを超えるもの

(b) Devices with a maximum combined output frequency exceeding 43.5 gigahertz

ハ 周波数切換え所要時間が一ミリ秒未満のもの

(c) Signal generators for which the required time for frequency cycling is less

than 1 millisecond

ニ 搬送波に対する一ヘルツ当たりの単側波帯位相雑音の比が次に掲げる式により算定した値未満のもの

(d) Signal generators for which the value is less than the value of the single side band phase noise ratio per hertz relative to carrier signal as calculated according to the following method

$20 \log 10$  (メガヘルツで表した動作周波数)  $- 20 \log 10$  (ヘルツで表した動作周波数とオフセット周波数の隔たり)  $- 126$

$20 \log 10$  (operating frequency expressed in megahertz)  $- 20 \log 10$

(difference between the operating frequency expressed in hertz and the offset frequency)  $- 126$

十四 ネットワークアナライザーであって、最大動作周波数が四三・五ギガヘルツを超えるもの（他の貨物に使用するように設計したものを除く。）

(xiv) Network analyzers with a maximum operating frequency exceeding 43.5 gigahertz (excluding those designed for use in other goods)

十五 マイクロ波用試験受信機であって、次のイ及びロに該当するもの（他の貨物に使用するように設計したものを除く。）

(xv) Microwave receivers that fall under the following (a) and (b) (excluding those designed for use in other goods)

イ 四三・五ギガヘルツを超える周波数で使用することができるように設計したもの

(a) Devices designed for use at frequencies exceeding 43.5 gigahertz

ロ 振幅及び位相を同時に測定できるもの

(b) Devices that can simultaneously measure amplitude and phase

十六 原子周波数標準器（ルビジウムを用いた周波数標準器であって、宇宙用に設計していないものを除く。）であって、次のいずれかに該当するもの（他の貨物に使用するように設計したものを除く。）

(xvi) Atomic frequency standards (excluding frequency standards employing rubidium that were not designed for use in space) that fall under any of the following (excluding those designed for use in other goods)

イ 三〇日間連続して発振したときの安定度が一、〇〇〇億分の一未満のもの

(a) Atomic frequency standards for which stability when oscillated continuously for a 30 day period is less than 1/ 100 billion

ロ 宇宙用に設計したもの

(b) Atomic frequency standards designed for space use

十六の二 スプレー冷却方式の熱制御装置であって、密閉された装置の中で冷媒の循環利用ができるもののうち、電気部品に絶縁冷媒を吹き付けて部品の温度を一定の範囲に収めるために特に設計した噴霧ノズルを有するもの又はそのために特に設計した部分品

(xvi)-2 Among spray cooling method temperature control devices that are capable of cyclic use of the cooling medium within a closed device, those

having atomizing nozzles specifically designed to spray isolating cooling medium on electric components and bring the components' temperature to within a fixed range, or the components specifically designed for that purpose

十七 半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置若しくは試験装置若しくは集積回路の製造用のマスク若しくはレチクルであって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品若しくは附属品

(xvii) Equipment for the manufacture or test of semiconductor devices, integrated circuits or semiconductor materials, or masks or reticles for the manufacture of integrated circuits, that fall under any of the following, or the components and accessories thereof

イ 結晶のエピタキシャル成長装置であって、次のいずれかに該当するもの

(a) Crystal epitaxial growth systems that fall under any of the following

(一) 次のいずれかに該当する膜を形成することができるもの

1. Devices capable of forming films that fall under any of the following

1 シリコン膜であって、二〇〇ミリメートル以上の長さにより膜の厚さの許容差の絶対値が二・五パーセント未満のもの

i. Silicon films for which the absolute value of the tolerance of the film thickness along a length of 200 millimeters or more is less than 2.5 %

2 シリコン以外の物質の膜であって、七五ミリメートル以上の長さにより膜の厚さの許容差の絶対値が二・五パーセント未満のもの

ii. Film of materials other than silicon for which the absolute value of the tolerance of the film thickness along a length of 75 millimeters or more is less than 2.5 %

(二) 有機金属化学的気相成長反応炉であって、第二十号又は第二十一号に該当する材料を化学的に反応させることにより化合物半導体の結晶を成長させるもの

2. Metal-organic chemical vapor deposition reactors that grow compound semiconductor crystals by causing a chemical reaction among materials that fall under item (xx) or item (xxi)

(三) ガス源又は固体源を用いた分子線エピタキシャル成長装置

3. Molecular beam epitaxial growth systems employing gas sources or solid sources

ロ イオン注入装置であって、次のいずれかに該当するもの

(b) Ion implanters that fall under any of the following

(一) ビームエネルギーが一メガ電子ボルトを超えるもの

1. Ion implanters with a beam energy exceeding 1 megaelectron volt

(二) ビームエネルギーが二キロ電子ボルト未満で使用することができるように設計したもの

2. Ion implanters designed for use at beam energies of less than 2

kiloelectron volts

(三) 直接描画を行うことができるもの

**3. Ion implanters which are capable of direct writing**

(四) ビームエネルギーが六五キロ電子ボルト以上、かつ、ビーム電流が四五ミリアンペア以上のものであって、加熱された半導体材料の基板に酸素を注入することができるもの

**4. Ion implanters with beam energies of 65 kiloelectron volts or more and beam currents of 45 milliamperes or more, that are capable of implanting oxygen on a heated superconductor material substrate**

ハ 異方性プラズマドライエッチング装置であって、カセットツウカセット機能及びロードロック機能を有するもの又はホに該当するものに接続して使用するよう  
に設計したもののうち、次のいずれかに該当するもの

(c) Among anisotropic plasma dry etching devices having cassette-to-cassette functions and load lock functions or devices designed to be connected to and used with equipment falling under (e), those that fall under any of the following

(一) 最小線幅のプラスマイナス三シグマの分布をプラスマイナス五パーセントの範囲に収め、かつ、一八〇ナノメートル以下の最小線幅を実現することができるもの

1. Equipment that contains a minimum line width of plus/minus 3 sigma distribution within a range of plus/minus 5%, and that can achieve a minimum line width of 180 nanometers or less.

(二) 直径〇・一マイクロメートルを超えるパーティクルの発生が一平方センチメートル中に〇・〇四個未満となるように設計したもの

2. Equipment designed so that the generation of particles exceeding 0.1 micrometers in diameter is less than 0.04 particles in 1 square centimeter.

ニ プラズマ増殖型の化学的気相成長装置であって、カセットツウカセット機能及びロードロック機能を有するもの又はホに該当するものに接続して使用するよう  
に設計したもののうち、最小線幅が一八〇ナノメートル以下の半導体素子の製造  
に使用されるもの

(d) Among plasma breeding chemical vapor deposition systems having cassette-to-cassette functions and load lock functions or systems designed to be connected to and used with equipment falling under (e), those that are used in the manufacture of semiconductor devices with a minimum line width of 180 nanometers or less

ホ 自動的にウエハーの装填を行うことができるマルチチャンバー対応ウエハー搬送中央装置であって、次の(一)及び(二)に該当するもの

(e) Automatic loading multi-chamber central wafer handling systems that fall under the following 1. and 2.

(一) 三台以上の半導体製造装置を接続できるウエハーの出し入れ用接続部を



有するもの

1. Interfaces for wafer input and output that can be connected to 3 or more units of semiconductor manufacturing equipment

(二) 複数のウェハーの処理を連続して行うために真空状態で一体化された装置を構成するように設計したもの

2. Equipment designed to form an integrated system in a vacuum environment for sequential multiple wafer processing

へ リソグラフィ装置であって、次のいずれかに該当するもの

(f) Lithography equipment that falls under any of the following

(一) ウェハーの処理のためのステップアンドリピート方式又はステップアンドスキャン方式の露光装置であって、光学方式のもの又はエックス線を用いたもののうち、次のいずれかに該当するもの

1. Step and repeat method or step and scan method align and expose equipment for wafer processing using photo-optical or x-ray methods, that falls under any of the following

1 光源の波長が二四五ナノメートル未満のもの

i. Equipment with a light source wavelength shorter than 245 nanometers

2 ナノメートルで表した光源の波長に $0.45$ を乗じて得た数値を開口数の値で除して得た数値が一八〇以下のもの

ii. Equipment for which the value obtained by multiplying the exposure light source wavelength expressed in nanometers by  $0.45$ , then dividing that value by the numerical aperture is 180 or less

(二) マスク、半導体素子又は集積回路の製造をすることができるように設計した装置であって、電子ビーム、イオンビーム又はレーザー光を用いた装置のうち、次のいずれかに該当するもの

2. Equipment designed to be capable of manufacturing masks, semiconductor devices or integrated circuits, among those using electron beams, ion beams or laser beams, those that fall under any of the following

1 照射面の直径が $0.2$ マイクロメートル未満のもの

i. Equipment with an irradiated area having a diameter of less than 0.2 micrometers

2  $0.2$ マイクロメートル未満の線幅のパターンを焼き付けることができるもの

ii. Equipment that can burn a pattern with a line width of less than 1 micrometer

3 重ね合わせ精度の絶対値が $0.2$ マイクロメートル未満のもの

iii. Equipment with an overlay precision absolute value of less than 0.2 micrometers

ト マスク又はレチクルであって、次のいずれかに該当するもの

(g) Masks and reticles that fall under any of the following

(一) 第一号から第八号までのいずれかに該当する集積回路の製造用のもの  
1. Masks and reticles used to manufacture integrated circuits that fall under any of item (i) through item (viii)

(二) 位相シフト膜を有する多層マスク（第一号に該当しない記憶素子を製造するために設計したものを除く。）

2. Multilayer masks with a phase shift layer (excluding those designed to manufacture storage elements that do not fall under item (i))

チ 試験装置であって、半導体素子若しくは集積回路又はこれらの半製品用のもののうち、次のいずれかに該当するもの

(h) Among test equipment for testing semiconductor devices or integrated circuits or those semi-finished products, those that fall under any of the following

(一) 三一・八ギガヘルツを超える周波数でトランジスタのエスパラメータを試験することができるように設計したもの

1. Test equipment designed for testing S-parameters of transistors at frequencies exceeding 31.8 gigahertz

(二) 削除

2. Deleted

(三) 第二号ハに該当するマイクロ波用集積回路の試験を行うことができるように設計したもの

3. Test Equipment designed for testing microwave integrated circuits that fall under item (ii), (c)

十八 次のいずれかに該当するものの多層膜からなるヘテロエピタキシャル成長結晶を有する基板

(xviii) Substrates having multiple layers consisting of heteroepitaxial growth crystals that fall under any of the following

イ シリコン

(a) Silicon

ロ ゲルマニウム

(b) Germanium

ハ 炭化けい素

(c) Silicon carbide

ニ III-V 族化合物（ガリウム又はインジウムの化合物に限る。）

(d) III-V compounds (limited to gallium or indium compounds)

十九 レジストであって、次のいずれかに該当するもの又はそれを塗布した基板

(xix) Resists that fall under any of the following or the substrates to which they have been applied

イ 半導体用のリソグラフィに使用するポジ形レジストであって、三五〇ナノメートル未満の波長の光で使用することができるように設計したもの

(a) Positive resists used in semiconductor lithography that are designed for use at a light wavelength of less than 350 nanometers

ロ ○・○一マイクロクーロン毎平方ミリメートル以下の電気量を照射する電子ビーム又はイオンビームに対する感度を有するもの

(b) Resists with sensitivity to electron beams or ion beams that deliver an electric charge of 0.01 microcoulombs per square millimeter or less

ハ 二・五ミリジュール毎平方ミリメートル以下のエネルギーを照射するエックス線に対する感度を有するもの

(c) Resists with sensitivity to x-rays that deliver an electric charge of 2.5 milijoules per square millimeter or less

ニ 表面イメージ技術を利用することができるように設計したもの（シリル化したレジストを含む。）

(d) Resists designed to be capable of utilizing surface image technology (including silylated resists)

二十 有機金属化合物又は有機化合物であって、次のいずれかに該当するもの

(xx) Organic metallic compounds or organic compounds that fall under any of the following

イ アルミニウム、ガリウム又はインジウムの有機金属化合物であって、純度が九九・九九九パーセントを超えるもの

(a) Aluminum, gallium or indium organic compounds with a purity exceeding 99.999%

ロ 燐、砒素又はアンチモンの有機化合物であって、純度が九九・九九九パーセントを超えるもの

(b) Phosphorus, arsenic or antimony organic compounds with a purity exceeding 99.999%

二十一 燐、砒素又はアンチモンの水素化物であって、純度が九九・九九九パーセントを超えるもの（二〇モルパーセント以上の不活性ガス又は水素を含んだものを除く。）

(xxi) Phosphorus, arsenic or antimony hydrides with a purity exceeding 99.999% (excluding those that contain inert gasses of 20 mole percent or less, or hydrogen)

第七条 輸出令別表第一の八の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

Article 7 Goods with specifications prescribed by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 8 of the appended table 1 of the Export Order shall fall under any of the following.

一 電子計算機若しくはその附属装置であって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品

(i) Computers or electronic assemblies thereof that fall under any of the following, or the components thereof

イ 八五度を超える温度又は零下四五度より低い温度で使用することができるように設計したもの

(a) Electronic computers or electronic assemblies thereof designed for use at temperatures exceeding 85 degrees centigrade or below -45 degrees centigrade

ロ 放射線による影響を防止するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの

(b) Electronic computers or electronic assemblies thereof designed to prevent the impact of radiation and that fall under any of the following

(一) 全吸収線量がシリコン換算で五、〇〇〇グレイを超える放射線照射に耐えられるように設計したもの

1. Electronic computers or electronic assemblies thereof designed to withstand atomic radiation with a total absorbed dose exceeding 5,000 grays on a silicon conversion basis

(二) 吸収線量がシリコン換算で一秒間に五、〇〇〇、〇〇〇グレイを超える放射線照射により障害を発生しないように設計したもの

2. Electronic computers or electronic assemblies thereof designed not to malfunction from an absorbed dose of atomic radiation exceeding 5 million grays per second on a silicon conversion basis

(三) 単事象障害によるエラー率が一日当たり一、〇〇〇万分の一毎ビット未満となるように設計したもの

3. Electronic computers or electronic assemblies thereof designed for a rate of error of less than 1/10 million per 1 bit per day from a single event error

ハ 次条第九号、第十号又は第十二号のいずれかに該当する貨物の有する機能と同等の機能を有するもの（第二十条第二項第九号に該当するプログラムのみにより次条第九号、第十号又は第十二号のいずれかに該当する貨物の有する機能と同等の機能を有するものを除く。）

(c) Electronic computers or electronic assemblies thereof with functions equivalent to the functions of goods which fall under any of item (ix), item (x) or item (xii) of the next Article (excluding those which have functions equivalent to the functions of goods that fall under the item (ix), item (x) or item (xii) of the next Article, solely because the programs thereof fall under Article 20, paragraph (2), item (ix))

二 削除

(ii) Deleted

三 デジタル電子計算機、その附属装置若しくはデジタル電子計算機の機能を向上するように設計した部分品であって、次のイからチまでのいずれかに該当するもの又はこれらの部分品（次のリからルまでのいずれかに該当するもの及びこれらの部分品を除く。）

(iii) Digital computers, electronic assemblies thereof or components designed to improve the functions of digital electronic computers that fall under any of the following (a) to (h), or the component thereof (excluding those and

components thereof that fall under any of the following (i) through (k)

イ フォールトトレラント機能を有するもの

(a) Those with fault tolerant functions

ロ 削除

(b) Deleted

ハ デジタル電子計算機であって、加重最高性能が〇・七五実効テラ演算を超えるもの

(c) Digital computers with Adjusted Peak Performance exceeding 0.75 Weighted TeraFLOPS

ニ 削除

(d) Deleted

ホ デジタル電子計算機の機能を向上するように設計した部分品であって、計算要素を集合させることにより、加重最高性能が〇・七五実効テラ演算を超えるもの

(e) Components designed to improve digital computer functions with Adjusted Peak Performance exceeding 0.75 Weighted TeraFLOPS

ヘ 削除

(f) Deleted

ト 前条第一号ホ（一）に規定する機能を有するもの

(g) Those with functions that fall under item (i), (e), 1. of the preceding Article

チ デジタル電子計算機又はその附属装置と外部との間でデータを転送するために設計した装置であって、データ転送速度が一・二五ギガバイト毎秒を超えるもの

(h) Equipment designed to transfer data between digital computers or electronic assemblies thereof and external devices, with a data transfer rate exceeding 1.25 gigabytes per second

リ 他の装置に内蔵されたものであって、当該装置を稼働するために必要不可欠であるもののうち、当該装置の主要な要素でないもの

(i) Among devices that are embedded in other equipment and that are indispensable to the operation of said equipment, those that are not key elements of said equipment

ヌ 他の装置に内蔵されたものであって、当該装置を稼働するために必要不可欠であるもののうち、その機能が当該装置の信号処理又は画像強調に限定されているもの

(j) Among devices that are embedded in other equipment and that are indispensable to the operation, those the functions of which are limited to signal processing or image enhancement of that equipment

ル 輸出令別表第一の九の項（一）から（三）まで、（五）又は（五の二）に掲げる貨物に内蔵されたものであって、当該装置を稼働するために必要不可欠であるもの

(k) Devices embedded in goods listed in row 9 (i) to (iii), (v) or (v-2) of the appended table 1 of the Export Order and that are indispensable to the

operation of those devices

四 電子計算機であつて、次のいずれかに該当するもの又はその附属装置若しくは部分品

(iv) Computers that fall under any of the following, or the electronic assemblies or components thereof

イ シストリックアレイコンピュータ

(a) Systolic array computers

ロ ニューラルコンピュータ

(b) Neural computers

ハ 光コンピュータ

(c) Optical computers

第八条 輸出令別表第一の九の項の経済産業省令で定める仕様のもは、次のいずれかに該当するものとする。

Article 8 Goods with specifications prescribed by the Ordinances of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 9 of the appended table 1 of the Export Order shall fall under any of the following.

一 通信装置、電子式交換装置、光ファイバー通信ケーブル、通信用の光ファイバー、フェーズドアレイアンテナ又は監視用の方向探知機であつて、次のいずれかに該当するもの

(i) Telecommunication equipment, electronic changers, optical fiber communication cables, telecommunication optical fibers, phased array antennas or radio direction finding equipment for monitoring use that fall under any of the following

イ 核爆発による過渡的な電子的効果又はパルスによる影響を防止することができるように設計したもの

(a) Equipment which is designed to be able to guard against transient electronic influence or pulses due to nuclear explosions

ロ ガンマ線、中性子線又は重荷電粒子線による影響を防止することができるように設計したもの（人工衛星に搭載するように設計したものを除く。）

(b) Equipment which is designed to prevent the effect of gamma rays, neutron beams or heavy electric particle rays (excluding equipment designed for mounting on satellites)

ハ 一二四度を超える温度又は零下五五度より低い温度で使用することができるように設計したものであつて、電子回路を有するもの（人工衛星に搭載するように設計したものを除く。）

(c) Equipment which is designed for use at temperatures exceeding 124 degrees centigrade or at temperatures lower than -55 degrees centigrade and having electronic circuits (excluding those designed for mounting on satellites)

二 伝送通信装置又はその部分品若しくは附属品であつて、次のいずれかに該当する

もの

(ii) Telecommunication transmission equipment, or components thereof or accessories that fall under any of the following

イ 無線送信機又は無線受信機であって、次のいずれかに該当するもの

(a) Radio transmitters or radio receivers that fall under any of the following

(一) 一・五メガヘルツ以上八七・五メガヘルツ以下の周波数範囲で使用することができるものであって、次の1及び2に該当するもの又は3に該当するもの

1. Telecommunication transmission equipment which can be used within a frequency range of 1.5 megahertz or more and 87.5 megahertz or less that fall under the following i. and ii. or iii.

1 最適送信周波数及び一チャンネル当たりの最適総合伝送速度を自動的に予測及び選択することができるもの

i. Telecommunication transmission equipment which is capable of automatically measuring and selecting the optimum transmission frequency and the optimum general transfer rate per channel

2 次の一から四までのすべてに該当する線形増幅器を用いたもの

ii. Telecommunication transmission equipment which uses linear amplifiers that fall under all of the following a. through d.

一 二つ以上の信号を同時に増幅することができるもの

a. Telecommunication transmission equipment which are capable of amplifying two or more signals simultaneously

二 一・五メガヘルツ以上三〇メガヘルツ未満の周波数範囲においては一キロワット以上の出力、三〇メガヘルツ以上八七・五メガヘルツ以下の周波数範囲においては二五〇ワット以上の出力特性を有するもの

b. Telecommunication transmission equipment having output characteristics of at least 1 kilowatts within a frequency range of 1.5 megahertz or more and less than 30 megahertz, and of at least 250 watts within a frequency range of 30 megahertz or more and 87.5 megahertz or less

三 一オクターブ以上の瞬時帯域幅を有するもの

c. Telecommunication transmission equipment having an instantaneous bandwidth of 1 octave or more

四 信号波に対する高調波又は歪成分の比がマイナス八〇デシベル未満のもの

d. Telecommunication transmission equipment for which the high frequency or distortion component ratio relative to signal waves is less than - 80 decibels

3 適応型の干渉信号抑圧技術を用いたものであって、干渉信号を一五デシベルを超えて抑圧することができるように設計したもの

iii. Telecommunication transmission equipment which uses adaptive interference signal restraint technology and are designed to keep

interference signals above 15 decibels

- (二) スペクトル拡散（周波数ホッピングを含む。）技術を用いたものであって、次のいずれかに該当するもの（出力が一・〇ワット以下のものを除く。）
2. Telecommunication transmission equipment which uses spectrum spread (including frequency hopping) and which fall under any of the following (excluding those with an output of 1.0 watts or less)
- 1 使用者によって拡散符号の書換えができるもの
    - i. Telecommunication transmission equipment in which diffusion code is capable of being rewritten by the user
      - 2 送信帯域幅が情報チャネルの帯域幅の一〇〇倍以上であり、かつ、五〇キロヘルツを超えるもの（民生用のセルラー無線通信に使用するよう設計したものを除く。）
      - ii. Telecommunication transmission equipment having a transmission bandwidth of 100 times or more the bandwidth of the information channel and exceeding 50 kilohertz (excluding those designed to be used for public cellular radio communication)
  - (三) ウルトラワイドバンド技術を用いたものであって、使用者によってチャネル符号又はスクランブル符号の書換えができるもの
3. Telecommunication transmission equipment which uses ultra-wide bandwidth technology having a channel code or scramble code which are capable of being rewritten by the user
- ロ デジタル信号処理機能を有するものであって、音声帯域圧縮技術を用いたもののうち、符号化速度が二、四〇〇ビット毎秒未満のもの
- (b) Among telecommunication transmission equipment having a digital signal processing function that uses voice band compression technology, those with a coding speed of less than 2,400 bits per second
- ハ 水中で使用することができるように設計した通信装置であって、次のいずれかに該当するもの
- (c) Communication equipment designed for use under water that falls under any of the following
- (一) 音波（超音波を含む。）を利用したものであって、搬送周波数が二〇キロヘルツ未満又は六〇キロヘルツを超えるもの
    1. Communication equipment which utilizes acoustic waves (including ultrasound) having a carrier frequency of less than 20 kilohertz or exceeding 60 kilohertz
    - (二) 電磁波を利用したものであって、搬送周波数が三〇キロヘルツ未満のもの
      2. Communication equipment which utilizes electromagnetic waves and has a carrier frequency of less than 30 kilohertz
      - (三) 電子的にビームを走査する機能を有するもの



3. Communication equipment having a function whereby beams are scanned electronically

三 削除

(iii) Deleted

四 光ファイバー通信ケーブル若しくは通信用の光ファイバー又はこれらの附属品であつて、次のいずれかに該当するもの

(iv) Optical fiber communication cables or optical fibers for communications use or accessories of these which fall under any of the following

イ 通信用の光ファイバーであつて、長さが五〇〇メートルを超えるもののうち、引張強さが二ギガニュートン毎平方メートル以上のもの

(a) Among Communication optical fibers with a length exceeding 500 meters, those that have a tensile strength of 2 giganewtons per square meter or more

ロ 水底敷設用に設計された光ファイバー通信ケーブル又はその附属品（通信事業者が使用する公衆回線又は第十一条第四号イ（三）若しくは二に掲げるものを除く。）

(b) Optical fiber communications cables designed for underwater installations or accessories of these (excluding those public circuits used by communications businesses or those indicated in Article 11, item (iv), (a), 3. or (ii))

五 電子的に走査が可能なフェーズドアレーアンテナであつて、三一・八ギガヘルツを超える周波数で使用することができるように設計したもの（国際民間航空機関の標準に準拠したマイクロ波着陸システム（MLS）用のものを除く。）

(v) Phased array antennas which are capable of being scanned electronically and which are designed for use at frequencies exceeding 31.8 gigahertz (excluding those used for microwave land systems (MLS) based on international civil aviation standards)

五の二 動作周波数が三〇メガヘルツを超える監視用の方向探知機であつて、次のイからハまでのすべてに該当するもの又はその部分品

(v)-2 Radio direction finding equipment for monitoring with an operating frequency exceeding 30 megahertz that falls under all of the following (a) through (c), or components thereof

イ 一メガヘルツ以上の瞬時帯域幅を有するもの

(a) Radio direction finding equipment having an instantaneous bandwidth of 1 megahertz or more

ロ 一〇〇周波数チャンネルを超える並列処理ができるもの

(b) Radio direction finding equipment which are capable of carrying out parallel processing exceeding 100 frequency channels

ハ 方向探知の処理速度が一チャンネル当たり一秒につき一、〇〇〇を超えるもの

(c) Radio direction finding equipment the directions finding processing speed of which exceeds 1,000 per second per channel

六 第二号イ（二）若しくは第十四条第五号に該当する貨物の設計用の装置、製造用の装置、測定装置、試験装置若しくは修理用の装置又はこれらの部分品若しくは附属品

(vi) Equipment for the design, manufacture, measurement, test, or repair of goods that fall under item (ii), (a), 2. or Article 14, item (v), or components or accessories thereof

七 前号に掲げるもののほか、第一号、第二号、第四号、第五号若しくは第五号の二のいずれかに該当する貨物の設計用の装置、製造用の装置、測定装置、試験装置若しくは修理用の装置（光ファイバーの試験装置及び測定装置を除く。）又はこれらの部分品若しくは附属品

(vii) In addition to what is listed in the preceding item, equipment for the design, manufacture, measurement, test, or repair of goods (excluding optical fiber testing equipment and measuring equipment) that fall under any of item (i), item (ii), item (iv), item (v), or item (v)-2, or components or accessories thereof

八 削除

(viii) Deleted

八の二 次のいずれかに該当する伝送通信装置若しくは電子式交換装置の設計用の装置又はその部分品若しくは附属品（第六号に該当するものを除く。）

(viii)-2 Equipment for the design of telecommunication transmission equipment or electronic changers that fall under any of the following, or components or accessories thereof (excluding those that fall under item (vi))

イ デジタル伝送方式を用いたものであって、一五ギガビット毎秒を超える総合伝送速度（最高位多重化レベルにおける単位時間当たりの信号ビット（情報ビット並びにラインコーティング及びオーバーヘッドその他の付加ビットを含む。）数をいう。）で使用することができるように設計したもの

(a) Equipment which uses a digital transmission system and which is designed for use at a general transmission speed exceeding 15 gigabits per second (this is the number of signal bits per unit of time at the highest order multiplexing level (including information bits, line coating and overhead and other additional bits))

ロ レーザー発振器を用いたものであって、次のいずれかに該当するもの

(b) Equipment using laser oscillators that falls under any of the following

(一) 一、七五〇ナノメートルを超える波長のレーザー光を利用するもの

1. Laser oscillators which utilize laser light having a wavelength of more than 1,750 nanometers

(二) レーザー光を増幅する機能を有するもの

2. Laser oscillators having a function for amplifying laser light

(三) コヒーレント伝送方式を用いたもの

3. Laser oscillators which use a coherent transmission system

(四) アナログ伝送方式を用いたものであって、帯域幅が二・五ギガヘルツを

を超えるもの（テレビジョン放送（有線テレビジョン放送を含む。）用の装置を除く。）

4. Laser oscillators which use an analog transmission system with a bandwidth exceeding 2.5 gigahertz (excluding television broadcasts (including CATV broadcasts))

ハ 光交換機能を有するもの

- (c) Laser oscillators having an optical switching function

ニ 無線送信機又は無線受信機であって、二五六値を超える直交振幅変調技術を用いたもの

- (d) Radio transmitters or radio receivers which use quadrature amplitude modulation technology exceeding 256

ホ 非対応網で動作する共通線信号機能を有するもの

- (e) Equipment having common channel signaling functions that operate in non compliant networks

九 暗号装置であって、次のイからホまでのいずれかに該当するもの（次のへからルまでのいずれか又は第三条第十九号ハ（二）2又は第十条第五号イに該当するものを除く。）又はその部分品

- (ix) Encryption equipment that fall under any of the following (a) through (e) (excluding those falling under any of the following (f) through (k), or Article 3, item (xix) (c), 2., ii, or Article 10, item (v) (a)) or components thereof.

イ デジタル方式の暗号処理技術（アナログ方式の暗号処理をデジタル方式の暗号処理技術を用いて実行するものを含む。）を用い、認証又はデジタル署名のため以外の暗号機能を有するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの

- (a) Those which are designed to have the cryptographic functionality other than for authentication or digital signature employing digital techniques performing any cryptographic function (including those employing analogue principles when implemented with digital techniques), and fall under any of the following

（一） 対称アルゴリズムを用いたものであって、アルゴリズムの鍵の長さが五六ビットを超えるもの

1. Those which use the symmetric algorithm employing a key length in excess of 56 bits

（二） 非対称アルゴリズムを用いたものであって、アルゴリズムの安全性が次のいずれかの有する困難性に基づくもの

2. Those which use the asymmetric algorithm where the security of the algorithm is based on the difficulty of any of the following

1 五一二ビットを超える整数の素因数分解

- i. Factorisation of integers in excess of 512 bits

2 有限体上の乗法群における五一二ビットを超える離散対数の計算

- ii. Computation of discrete logarithms in a multiplicative group of a

finite field of size greater than 512 bits

3 2に規定するもの以外の群における一一二ビットを超える離散対数の計算  
iii. Computation of the discrete logarithms in a group other than  
mentioned in ii in excess of 112 bits

ロ 暗号解析を行うように設計したもの

(b) Those which are designed for performing cryptanalytic functions

ハ スペクトル拡散のための拡散符号の生成（周波数ホッピングのためのホッピング符号の生成を含む。）に暗号処理技術を用いるように設計したもの（ニに該当するものを除く。）

(c) Those which are designed to use the cryptographic techniques to generate the spreading code for spread spectrum systems (including the generation of the hopping code for frequency hopping systems) (excluding those that fall on (d)).

ニ 次のいずれかに該当するウルトラワイドバンド変調技術のためのチャンネル符号、スクランブル符号又はネットワーク認識符号の生成に暗号処理技術を用いるように設計したもの

(d) Those which are designed to use cryptographic techniques to generate channelizing codes, scrambling codes or network identification codes for systems using ultra-wideband modulation techniques that fall under any of the following

(一) 帯域幅が五〇〇メガヘルツを超えるもの

1. Those whose bandwidth exceeds 500 MHz

(二) 瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が二〇パーセント以上のもの

2. Those in which the figure gained by dividing the instantaneous bandwidth by the center frequency is over 20 percent

ホ 量子暗号を用いるように設計したもの

(e) Those which are designed to use the quantum cryptography

ヘ ICカードであって、その暗号機能が次のトからルまでのいずれかに該当する装置に限定されて使用するもの又は広く一般に使用されるものであって、その暗号機能が使用者によって変更できず、かつ、当該ICカードに保存されている個人情報に保護に限定して使用するよう設計したもの

(f) IC cards whose cryptographic functionality is limited in use for any of the equipments that fall under following (g) to (k), or whose cryptographic functionality is widely in general use, and whose cryptographic functionality cannot be changed by users, and designed to use exclusively for protecting personal data stored in those IC cards.

ト ラジオ放送又は特定加入者用放送（テレビジョン放送にあつては、有線テレビジョン放送を含む。）の受信装置であつて、復号化機能のみ又は加入者から放送事業者（テレビジョン放送事業者にあつては、有線テレビジョン放送事業者を含む。）への課金情報若しくは番組関連情報を送信するための暗号化機能のみを有するもの

(g) Receiving equipment for radio broadcast or restricted audience broadcast of consumer type (including cable television broadcast in television broadcasting), and that has functionality to decode only, or functionality to cryptograph only for sending billing or programme-related information back to the broadcast providers (including cable television providers in television broadcasting providers)

チ 使用者によって暗号機能の変更ができない装置であって、暗号機能として次のいずれかに該当する一又は二以上のもののみを有するように設計したもの

(h) Equipment where the cryptographic capability is not user-accessible, and those are designed to have only the one or more that fall under any of the following as the cryptographic functionality

(一) コピー防止されたプログラムを実行するための機能

1. Functionality to execute copy-protected programs

(二) コピー防止された読み出し専用媒体上のデジタルコンテンツにアクセスをするための機能

2. Functionality to access to digital contents stored on copy-protected read-only media

(三) 同一内容で公衆に販売される媒体上に暗号化して記憶されたデジタルコンテンツにアクセスをするための機能

3. Functionality to access to encrypted and memorized digital contents on a medium that will be sold to the public with the same content

(四) 著作権が保護された音声又は映像データの複製を管理する機能

4. Functionality for copying control of copyright protected audio/video data

(五) 半導体デバイス又は集積回路の設計用のライブラリ、設計属性又は設計関連データを保護する暗号化、復号化又は暗号復号化機能

5. Functionality to encrypt and/or decrypt to protect libraries, design attributes, or associated data for the design of semiconductor devices or integrated circuits

リ 暗号装置であって、銀行業務又は決済に使用するように設計したもの

(i) Cryptographic equipment designed for banking use or settlements transactions

ヌ 民生用の携帯用電話機端末又は移動用電話機端末であって、電話機端末間での暗号化機能を有しないもの

(j) Portable or mobile radiotelephones for civil use or mobile telephone terminals that do not have cryptographic functionality between radiotelephones.

ル コードレス電話機端末間での暗号化機能を有しないコードレス電話装置であって、コードレス電話機端末と家庭内基地局の間に無線中継器がない場合の一無線区間での電波到達最長実効距離が四〇〇メートル未満のもの

(k) Cordless telephone equipment not capable of end-to-end encryption where the maximum effective range of unboosted cordless operation is less than

400 meters in a single, unrelayed hop between terminal and home base station

十 情報を伝達する信号の漏えいを防止するように設計した装置（電磁波の放射による人体への危害若しくは他の装置の誤動作の誘発を防止することを目的として信号の漏えいを防止するように設計したもの又は電磁波妨害防止標準に基づいて信号の漏えいを防止するように設計したものを除く。）又はその部分品

(x) Equipment designed to prevent the leakage of information transmission signals (excluding equipment designed to prevent the leakage of signals to prevent bodily harm or malfunctions of other equipment caused by radiation of electromagnetic waves or designed to prevent leakage of signals based on electromagnetic wave obstruction standards), or components thereof

十一 削除

(xi) Deleted

十二 盗聴の検知機能を有する通信ケーブルシステム又はその部分品

(xii) Communication cable systems capable of detecting surreptitious intrusion, or components thereof

十三 第九号、第十号又は前号のいずれかに該当する貨物の設計用の装置、製造用の装置、測定装置、試験装置又は修理用の装置

(xiii) Equipment for the design, manufacture, measurement, test or repair of goods that falls under any of item (ix), item (x) or the preceding item

第九条 輸出令別表第一の一〇の項の経済産業省令で定める仕様のもは、次のいずれかに該当するものとする。

Article 9 Goods with specifications prescribed by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 10 of the appended table 1 of the Export Order shall fall under any of the following.

一 音波（超音波を含む。以下この条において同じ。）を利用した水中探知装置、船舶用の位置決定装置又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの

(i) Underwater acoustic equipment utilizing acoustic waves (including ultrasound; hereinafter the same shall apply in this Article), positioning device for vessels or components thereof which fall under any of the following

イ 送信機能を有するもの又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの（垂直方向にのみ使用することができるものであって、プラスマイナス二〇度を超える走査機能を有していないもののうち、水深の測定、水中にある物体若しくは水底に埋もれた物体までの距離の測定又は魚群探知のみを行うもの及び音響用のビーコンであって、緊急用のもの又は水中の任意の位置に設置することができるように設計したピンガーを除く。）

(a) Those having a transmission function or components thereof which fall under any of the following (excluding those used solely for ocean depth measurement, for measuring underwater objects or the distance to objects buried under water or for finding schools of fish, as well as acoustic

beacons, and emergency items and pingers designed to be installed at any position under water, among those used solely for vertical direction not having a scanning function exceeding plus/minus 20 degrees)

(一) 水底の地形図を作成するための測深機であって、次の1及び2に該当するもの

1. Sounding devices used for underwater mapping that fall under the following i. and ii.

1 垂直方向から二〇度を超える角度での測定ができるように設計し、かつ、水面下六〇〇メートルを超える水深を測定することができるように設計したもの

i. Sounding devices designed for measurement at angles which exceed 20 degrees from the vertical direction and designed to measure ocean depths exceeding 600 meters beneath the surface of the water

2 多重ビーム（いずれかの音響ビームのビーム幅が一・九度未満のものに限る。）を組み込むように設計したもの又は測深の精度の平均値が〇・三パーセント未満となるように設計したもの

ii. Sounding devices designed to incorporate multiple beams (limited to those with an acoustic beam width of less than 1.9 degrees) or designed so that the average sounding precision value is less than 0.3 %.

(二) 水中探知装置であって、次のいずれかに該当するもの

2. Underwater acoustic equipment which falls under any of the following

1 送信周波数が五キロヘルツ未満のもの又は動作周波数が五キロヘルツ以上一〇キロヘルツ未満であって、音圧レベル（音源から一メートルの距離で音圧が一マイクロパスカルである場合を〇デシベルとしたときのものをいう。以下この号において同じ。）が二二四デシベルを超えるもの

i. Underwater acoustic equipment in which the transmission frequency is less than 5 kilohertz or in which the operating frequency is 5 kilohertz or more and less than 10 kilohertz, and the acoustic compression level (0 decibels when the acoustic compression is 1 micro pascal at a distance of 1 meter from the source of the sound. Hereinafter the same shall apply in this item) of which exceeds 224 decibels

2 動作周波数が一〇キロヘルツ以上二四キロヘルツ以下であって、音圧レベルが二二四デシベルを超えるもの

ii. Underwater acoustic equipment with an operating frequency of 10 kilohertz or more and 24 kilohertz or less and with an acoustic compression level exceeding 224 decibels

3 動作周波数が二四キロヘルツ超三〇キロヘルツ未満であって、音圧レベルが二三五デシベルを超えるもの

iii. Underwater acoustic equipment, the operating frequency of which

- exceeds 24 kilohertz and is less than 30 kilohertz and the acoustic compression level of which exceeds 235 decibels
- 4 動作周波数が一〇〇キロヘルツ未満であって、ビーム幅が一度未満の音響ビームを成形することができるもの
- iv. Underwater acoustic equipment, the operating frequency of which is less than 100 kilohertz and the beam width of which is capable of forming acoustic beams of less than 1 degree
- 5 一、〇〇〇メートルを超える水深で使用することができるように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
- v. Underwater acoustic equipment which is designed for use at depths exceeding 1,000 meters which falls under any of the following
- 一 水圧を補正することができる送受波器を有するもの
- a. Underwater acoustic equipment having a transducer which is capable of compensating for water pressure
- 二 チタン酸ジルコン酸鉛からなる送受信素子以外の送受信素子を組み込んだ送受波器を有するもの
- b. Underwater acoustic equipment having a transducer (an echo sender and receiver) with built-in transmitting and receiving element other than sending and receiving elements made of lead zirconate titanate
- 6 計測距離が五、一二〇メートルを超えるように設計したもの
- vi. Underwater acoustic equipment designed so that the measuring distance exceeds 5,120 meters
- (三) 水中探知装置であって、送信周波数が一〇キロヘルツ未満のもの（(二)に該当するものを除く。）
3. Underwater acoustic equipment with a transmission frequency of less than 10 kilohertz (excluding those falling under 2.)
- (四) 音響送波器（送受波器を含む。）であって、次のいずれかに該当するもの（音波の発生装置であって、電子式のもの（垂直方向にのみ使用することができるものに限る。）又は機械式若しくは化学式のものを除く。）
4. Acoustic transmitters (including transducers) which fall under any of the following (excluding sonic water generators which are electronic (limited to those which are capable of being used only in a vertical direction) or mechanical or chemical)
- 1 一〇キロヘルツ未満の周波数で使用することができるものであって、瞬間的に送信した場合の音響出力密度が〇・〇一ミリワット毎平方ミリメートル毎ヘルツを超えるもの
- i. Acoustic transmitters which are capable of being used at frequencies of less than 10 kilohertz and the acoustic output density of which when transmitting instantaneously exceeds 0.01 milliwatts per square millimeter per hertz
- 2 一〇キロヘルツ未満の周波数で使用することができるものであって、持続



波を送信した場合の音響出力密度が〇・〇〇一ミリワット毎平方ミリメートル毎ヘルツを超えるもの

- ii. Acoustic transmitters which are capable of being used at frequencies of less than 10 kilohertz and the acoustic output density of which when transmitting continuous waves exceeds 0.001 milliwatts per square millimeter per hertz

3 サイドローブに対するメインローブの出力比が二二デシベルを超えるもの

- iii. Acoustic transmitters in which the main rope output ratio to that of the side rope exceeds 22 decibels

- (五) 船舶用の位置決定装置又はその部分品であって、応答機から一、〇〇〇メートルを超える距離で使用することができるように設計したもののうち、応答機から一、〇〇〇メートルの距離における位置精度の二乗平均が一〇メートル未満のもの

- 5. Among acoustic equipment for determining the position of vessels or components thereof which are designed so that they are capable of being used at a distance exceeding 1,000 meters from a transponder, those in which the root mean square for positioning precision at a distance of 1,000 meters from a transponder is less than 10 meters

ロ 受信機能を有するもの又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの

- (b) Acoustic equipment possessing a receiving function or components thereof that fall under any of the following

- (一) ハイドロホンであって、加速度による影響を補正する機能を有していないもののうち、その音圧感度（一ボルト毎マイクロパスカルである場合を〇デシベルとしたときのものをいう。以下この号において同じ。）がマイナス一八〇デシベルを超えるもの

- 1. Among hydrophones without a function which compensates for the effects of acceleration (0 decibels with 1 volt per micropascal; hereinafter the same shall apply in this item), those with an acoustic compression sensitivity which exceeds minus 180 decibels,

- (二) えい航ハイドロホンアレー用に設計した信号処理装置であって、使用者によるプログラムの書換えが可能なもののうち、時間領域又は周波数領域の処理又は相関（スペクトル分析、デジタルフィルタリング又はビーム成形を含む。）を行うことができるもの（実時間処理できるものを除く。）

- 2. Among signal processing equipment designed for towed hydrophone arrays and the programs of which are capable of being rewritten by the user, those which can carry out processing or correlation of the time domain or frequency domain (including spectrum analysis, digital filtering or beam formation) (excluding those which can process in real-time)

- (三) えい航ハイドロホンアレー用に設計したヘディングセンサーであって、精度の絶対値が〇・五度未満のものうち、三五メートルを超える水深で使

用することができるように設計したもの又は三五メートルを超える水深で使用することができるように調整若しくは取り外しをすることができる水深測定装置を有するもの

3. Among heading sensors which are designed for use in towed hydrophone arrays and having an absolute precision value of less than 0.5 degrees, those which are designed for use at depths exceeding 35 meters or those having a depth sounding device which are capable of being coordinated or removed so that heading sensors can be used at depths exceeding 35 meters

(四) 海底用又は港湾用ケーブルシステム用に設計した信号処理装置であって、使用者によるプログラムの書換えが可能なもののうち、時間領域又は周波数領域の処理又は相関（スペクトル分析、デジタルフィルタリング又はビーム成形を含む。）を行うことができるもの（実時間処理できるものを除く。）

4. Among signal processing equipment which are designed for sea floor or harbor cable systems and the programs of which are capable of being rewritten by the user, those which carry out processing or correlation of the time domain or the frequency domain (spectrum analysis, digital filtering or beam formation), (excluding real-time processing)

二 船舶用の対地速力の測定装置（音波を利用したものに限る。）であって、相関技術を用いたもののうち、水底から五〇〇メートルを超える位置で測定を行うことができるように設計したもの

(ii) Among measuring equipment for the horizontal speed of the equipment carrier relative to the seabed at distances between the carrier and the seabed (limited to those utilizing acoustic waves) and which use correlation technology, those which are designed so that measurements are capable of being carried out at a position exceeding 500 meters from the bottom of the water

三 光検出器又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの

(iii) Optical detectors or components thereof that fall under any of the following  
イ 宇宙用に設計した固体の光検出器（ゲルマニウム又はシリコンを用いたものを除く。）であって、次のいずれかに該当するもの

(a) Solid optical detectors designed for space use (excluding those using germanium or silicon) that fall under any of the following

(一) 一〇ナノメートル超三〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有し、かつ、四〇〇ナノメートルを超える波長における感度が最大感度の〇・一パーセント未満のもの

1. Solid optical detectors having a maximum sensitivity within a wavelength range exceeding 10 nanometers and 300 nanometers or less and the sensitivity at wavelengths exceeding 400 nanometers shall be less than 0.1% of a maximum sensitivity

(二) 九〇〇ナノメートル超一、二〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感

度を有し、かつ、応答時定数が九五ナノ秒以下のもの

2. Solid optical detectors having a maximum sensitivity within a wavelength range exceeding 900 nanometers and 1,200 nanometers or less, and with a response time constant of 95 nanoseconds or less
- ロ イメージ増強管（ゲルマニウム又はシリコンを用いたものを除く。）であって、次の（一）から（三）までのすべてに該当するもの

(b) Image reinforcing tubes (excluding those using germanium or silicon) which fall under all of the following 1. through 3.

(一) 四〇〇ナノメートル超一、〇五〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの

1. Image reinforcing tubes having a maximum sensitivity within a wavelength range exceeding 400 nanometers and 1,050 nanometers or less

(二) 隣接する二のチャンネルの中心間の距離が一マイクロメートル以下のマイクロチャンネルプレートを有するもの

2. Image reinforcing tubes having a micro channel plate wherein the distance between the center of two adjoining channels is 12 micrometers or less

(三) 次のいずれかに該当する光電陰極を有するもの

3. Image reinforcing tubes having a photocathode which falls under any of the following

- 1 主材料にマルチアルカリを用いたものであって、ルーメン感度が七〇〇マイクロアンペア毎ルーメンを超えるもの

- i. Photocathodes which use a multi-alkali for the main material and in which lumen sensitivity exceeds 700 microamperes per lumen

- 2 主材料に砒化ガリウム又は砒化インジウムガリウムを用いたもの

- ii. Photocathodes which use gallium arsenide or indium gallium arsenide as the main material

- 3 主材料に I I I—V 族化合物半導体（砒化ガリウム又は砒化インジウムガリウムを除く。）を用いたもの（最大放射感度が一〇ミリアンペア毎ワット以下のものを除く。）

- iii. Photocathodes which use a III-V compound semiconductor (excluding gallium arsenide or indium gallium arsenide) as the main material (excluding those with a maximum radiation sensitivity of 10 milliamperes per watt or less.)

ハ イメージ増強管（ゲルマニウム又はシリコンを用いたものを除く。）又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの

(c) Image reinforcing tubes (excluding germanium or silicon) or components thereof which fall under any of the following

(一) イメージ増強管であって、次の 1 から 3 までのすべてに該当するもの

1. Image reinforcing tubes which fall under all of the following i. through

- iii.
    - 1 四〇〇ナノメートル超一、〇五〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの
  - i. Image reinforcing tubes having a maximum sensitivity within a wavelength range exceeding 400 nanometers and 1,050 nanometers or less
    - 2 隣接する二のチャンネルの中心間の距離が一ニマイクロメートル以下のマイクロチャンネルプレートを有するもの
  - ii. Image reinforcing tubes having a micro channel plate in which the distance between the centers of two adjoining channels is 12 micrometers or less
    - 3 主材料にマルチアルカリを用いた光電陰極を有するものであって、当該光電陰極のルーメン感度が三五〇マイクロアンペア毎ルーメン超七〇〇マイクロアンペア毎ルーメン以下のもの
  - iii. Image reinforcing tubes having a photocathode which uses a multi-alkali as the primary material and in which lumen sensitivity in said photocathode exceeds 350 microamperes per lumen and is 700 microamperes per lumen or less
- (二) イメージ増強管の部分品であって、次のいずれかに該当するもの
2. Components of image reinforcing tubes which fall under any of the following
- 1 マイクロチャンネルプレートであって、隣接する二のチャンネルの中心間の距離が一ニマイクロメートル以下のもの
    - i. Micro channel plates wherein the distance between the center of two adjoining channels is 12 micrometers or less
    - 2 主材料に砒化ガリウム又は砒化インジウムガリウムを用いた光電陰極
  - ii. Photocathodes using gallium arsenide or indium gallium arsenide as the main material
    - 3 主材料にIII-IV族化合物半導体（砒化ガリウム又は砒化インジウムガリウムを除く。）を用いた光電陰極（最大放射感度が一〇ミリアンペア毎ワット以下のものを除く。）
  - iii. Photocathodes using a III-IV compound semiconductor (excluding gallium arsenide or indium gallium arsenide) as the main material (excluding those with a maximum radiation sensitivity of 10 milliamperes per watt or less)
- ニ 宇宙用に設計していないフォーカルプレーンアレーであって、次の（一）及び（二）に該当するもの（素子の数が一六以下のカプセル封じをした光導電セルであって硫化鉛又はセレン化鉛を用いたもの及び焦電検出器であって硫酸三グリシン、チタン酸ジルコン酸鉛にランタンを添加したもの、タンタル酸リチウム、ポリふっ化ビニリデン又はニオブ酸ストロンチウムバリウムを用いたものを除く。）

(d) Focal plane arrays not designed for space use that fall under the following 1. and 2. (excluding photoconduction cells with a sealed-in capsule having 16 or fewer elements; those using lead sulfide or lead selenide as well as pyroelectric detectors, those in which lanthanum has been added to 3 glycine sulfate and lead zirconate titanate, those to which lithium tartarate, vinylidene polyfluoride or strontium barium niobate has been added)

(一) 次のいずれかに該当するもの

1. Focal plane arrays which fall under any of the following

1 熱型でないフォーカルプレーンアレー（ゲルマニウム又はシリコンを用いたものを除く。）であって、次のいずれかに該当するもの

i. Focal plane arrays which are not heat-molded (excluding germanium or silicon) and which fall under any of the following

一 要素素子が九〇〇ナノメートル超一、〇五〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有し、かつ、応答時定数が〇・五ナノ秒未満のもの

a. Focal plane arrays in which factor elements have a maximum sensitivity within a wavelength range exceeding 900 nanometers and 1,050 nanometers or less, and with a response time constant less than 0.5 nanoseconds

二 要素素子が一、〇五〇ナノメートル超一、二〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有し、かつ、応答時定数が九五ナノ秒以下のもの

b. Focal plane arrays in which factor elements have a maximum sensitivity within a wavelength range exceeding 1,050 nanometers and 1,200 nanometers or less, and with a response time constant of 95 nanoseconds or less

三 要素素子を二次元に配列したものであって、それぞれの要素素子が一、二〇〇ナノメートル超三〇、〇〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの

c. Focal plane arrays in which factor elements are arrayed two-dimensionally and in which the respective factor elements have a maximum sensitivity within a wavelength range exceeding 1,200 nanometers and 30,000 nanometers or less

四 要素素子を一次元に配列したものであって、それぞれの要素素子が一、二〇〇ナノメートル超二、五〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもののうち、次のいずれかに該当するもの

d. Among focal plane arrays in which factor elements are arrayed one-dimensionally and in which the respective factor elements have a maximum sensitivity within a wavelength range exceeding 1,200 nanometers and 2,500 nanometers or less, those which fall under any of the following

イ 要素素子の配列方向を基準とする要素素子の縦横比が三・八未満のもの

- 1 Focal plane arrays wherein the aspect ratio of the factor elements using the array direction of the factor elements is less than 3.8
  - ロ 同一要素素子内に時間遅延及び積分機能を有するもの
- 2 Focal plane arrays having a time delay and integrating function inside the same factor element
  - 五 要素素子を一次元に配列したものであって、それぞれの要素素子が二、五〇〇ナノメートル超三〇、〇〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの
- e. Focal plane arrays in which factor elements are arrayed one-dimensionally and in which the respective factor elements have a maximum sensitivity within a wavelength range exceeding 2,500 nanometers and 30,000 nanometers or less
  - 2 要素素子を二次元に配列した赤外線熱型フォーカルプレーンアレーであって、それぞれの要素素子がフィルターのない状態において八、〇〇〇ナノメートル以上一四、〇〇〇ナノメートル以下の波長範囲で感度を有するもの
- ii. Infrared ray heat-molded focal plane arrays in which factor elements are arrayed two-dimensionally and in which the respective factor elements have a sensitivity within a wavelength range of 8,000 nanometers or more and 14,000 nanometers or less in an unfiltered state
  - (二) 次のいずれかに該当するもの
2. Focal plane arrays which fall under any of the following
  - 1 白金シリコンを用いたものであって、素子の数が一〇、〇〇〇未満のもの
- i. Focal plane arrays which use platinum silicon with less than 10,000 elements
  - 2 イリジウムシリコンを用いたもの
- ii. Focal plane arrays which use iridium silicon
  - 3 アンチモン化インジウム又はセレン化鉛を用いたものであって、素子の数が二五六未満のもの
- iii. Focal plane arrays which use indium antimonide or lead selenide with less than 256 elements
  - 4 砒化インジウムを用いたもの
- iv. Focal plane arrays which use indium arsenide
  - 5 硫化鉛を用いたもの
- v. Focal plane arrays which use lead sulfide
  - 6 砒化インジウムガリウムを用いたもの
- vi. Focal plane arrays which use indium gallium arsenide
  - 7 テルル化水銀カドミウムを用いたスキャニングアレーであって、次のいずれかに該当するもの
- vii. Scanning arrays which use mercury cadmium telluride and which fall

under any of the following

- 一 同一検出素子内に時間遅延及び積分機能を有していないものであって、素子の数が三〇以下のもの
  - a. Scanning arrays which do not have a time delay and integrating function inside the same detection element with 30 or less elements
  - 二 同一検出素子内に時間遅延及び積分機能を有するものであって、素子の数が二以下のもの
  - b. Scanning arrays which have a time delay and integrating function inside the same detection element with 2 or less elements
  - 8 テルル化水銀カドミウムを用いたステアリングアレーであって、素子の数が二五六未満のもの
  - viii. Steering arrays which use mercury cadmium telluride with less than 256 elements
  - 9 砒化ガリウム又は砒化アルミニウムガリウムを用いた量子井戸フォーカルプレーンアレーであって、素子の数が二五六未満のもの
  - ix. Quantum well focal plane arrays which use gallium arsenide or aluminum gallium arsenide with less than 256 elements
  - 10 熱型フォーカルプレーンアレーであって、素子の数が八、〇〇〇未満のもの
  - x. Heat-molded focal plane arrays with less than 8,000 elements
- ホ 宇宙用に設計していないフォーカルプレーンアレーであって、次のいずれかに該当するもの（素子の数が一六以下のカプセル封じをした光導電セルであって硫化鉛又はセレン化鉛を用いたもの及び焦電検出器であって硫酸三グリシン、チタン酸ジルコン酸鉛にランタンを添加したもの、タンタル酸リチウム、ポリふっ化ビニリデン又はニオブ酸ストロンチウムバリウムを用いたものを除く。）のうち、二に該当するもの以外のもの
- (e) Among focal plane arrays which are not designed for space use that fall under any of the following (excluding photoconduction cells with a sealed-in capsule having 16 or fewer elements, using lead sulfide or lead selenide as well as pyroelectric detectors in which lanthanum has been added to 3 glycine sulfate and lead zirconate titanate, using lithium tartarate vinylidene polyfluoride or strontium barium niobate), those other than items that fall under (d)
  - (一) 熱型でないフォーカルプレーンアレー（ゲルマニウム又はシリコンを用いたものを除く。）であって、次のいずれかに該当するもの
  1. Focal plane arrays which are not heat-molded (excluding germanium or silicon) which fall under any of the following
    - 1 要素素子が九〇〇ナノメートル超一、〇五〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有し、かつ、応答時定数が〇・五ナノ秒未満のもの
    - i. Focal plane arrays in which factor elements have a maximum sensitivity within a wavelength range exceeding 900 nanometers and

- 1,050 nanometers or less, and with a response time constant less than 0.5 nanoseconds
- 2 要素素子が一、〇五〇ナノメートル超一、二〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有し、かつ、応答時定数が九五ナノ秒以下のもの
- ii. Focal plane arrays in which factor elements have a maximum sensitivity within a wavelength range exceeding 1,050 nanometers and 1,200 nanometers or less, and with a response time constant of 95 nanoseconds or less
- 3 要素素子を二次元に配列したものであって、それぞれの要素素子が一、二〇〇ナノメートル超三〇、〇〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの
- iii. Focal plane arrays in which factor elements are arrayed two-dimensionally and in which the respective factor elements have a maximum sensitivity within a wavelength range exceeding 1,200 nanometers and 30,000 nanometers or less
- 4 要素素子を一次元に配列したものであって、それぞれの要素素子が一、二〇〇ナノメートル超二、五〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもののうち、次のいずれかに該当するもの
- iv. Among focal plane arrays in which factor elements are arrayed one-dimensionally, and in which the respective factor elements have a maximum sensitivity within a wavelength range exceeding 1,200 nanometers and 2,500 nanometers or less, those which fall under any of the following
- 一 要素素子の配列方向を基準とする要素素子の縦横比が三・八未満のもの
- a. Focal plane arrays wherein the aspect ratio of the factor elements having a factor element array direction as a standard is less than 3.8
- 二 同一要素素子内に時間遅延及び積分機能を有するもの
- b. Focal plane arrays having a time delay and integrating function inside the same factor element
- 5 要素素子を一次元に配列したものであって、それぞれの要素素子が二、五〇〇ナノメートル超三〇、〇〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの
- v. Focal plane arrays in which factor elements are arrayed one-dimensionally and in which respective factor elements have a maximum sensitivity within a wavelength range exceeding 2,500 nanometers and 30,000 nanometers or less
- (二) 要素素子を二次元に配列した赤外線熱型フォーカルプレーンアレイであって、それぞれの要素素子がフィルターのない状態において八、〇〇〇ナノメートル以上一四、〇〇〇ナノメートル以下の波長範囲で感度を有するもの
2. Infrared heat-molded focal plane arrays in which factor elements are arrayed two-dimensionally and in which the respective factor elements



have a sensitivity within a wavelength range exceeding 8,000 nanometers and 14,000 nanometers or less in an unfiltered state

四 リモートセンシング用に設計したモノスペクトルイメージセンサー又はマルチスペクトルイメージセンサーであって、次のいずれかに該当するもの

(iv) Mono-spectrum image sensors or multi-spectrum image sensors designed for remote sensing which fall under any of the following

イ 瞬時視野が二〇〇マイクロラジアン未満のもの

(a) Mono-spectrum image sensors or multi-spectrum image sensors with an instant visual field of less than 200 microradians

ロ 四〇〇ナノメートル超三〇、〇〇〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するよう設計したものであって、イメージデータをデジタル形式で出力するものうち、次のいずれかに該当するもの

(b) Among mono-spectrum image sensors or multi-spectrum image sensors designed for use within a wavelength range exceeding 400 nanometers and 30,000 nanometers or less, in which image data are output digitally, those which fall under any of the following

(一) 宇宙用に設計したもの

1. Mono-spectrum image sensors or multi-spectrum image sensors designed for space use

(二) 航空機搭載用に設計したものであって、シリコンを用いた検出器以外の検出器を用いたものうち、瞬時視野が二・五ミリラジアン未満のもの

2. Among mono-spectrum image sensors or multi-spectrum image sensors designed for installation in aircraft using non-silicon detectors, those the instant field of vision of which is less than 2.5 milliradians

五 光検出器を用いた装置であって、直視型のものうち、次のいずれかに該当するもの（医療用装置であって、主材料に砒化ガリウム又は砒化インジウムガリウムを用いた光電陰極を組み込んでいないものを除く。）

(v) Among equipment which uses optical detectors having a direct field of vision, that which falls under any of the following (excluding medical equipment which do not have built-in photocathodes and which uses gallium arsenide or indium gallium arsenide as the main material)

イ 次のいずれかに該当する光検出器を組み込んだもの

(a) Equipment that incorporates optical detectors that fall under any of the following

(一) 第三号ロに該当するイメージ増強管

1. Image reinforcing tubes that fall under item (iii), (b)

(二) 第三号ホに該当するフォーカルプレーンアレー

2. Focal plane arrays that fall under item (iii), (e)

ロ 次のいずれかに該当する光検出器を組み込んだもの（イに該当するものを除く。）

(b) Equipment with built-in optical detectors which fall under any of the

following (excluding those that fall under (a))

(一) 第三号ハ (一) に該当するイメージ増強管

1. Image reinforcing tubes which fall under item (iii), (c), 1

(二) 第三号ニに該当するフォーカルプレーンアレー

2. Focal plane arrays which fall under item (iii), (d)

六 光検出器用の冷却器であって、次のいずれかに該当するもの

(vi) Coolers for optical detectors which fall under any of the following

イ 宇宙用に設計したもの

(a) Coolers for optical detectors designed for space use

ロ 宇宙用に設計していないものであって、冷却のための接触面の温度が零下五五度未満のもののうち、次のいずれかに該当するもの

(b) Among coolers for optical detectors which are not designed for space use, wherein the temperature of the contact surface used for cooling is less than -55 degrees centigrade, those which fall under any of the following

(一) 循環式のものであって、平均故障寿命又は平均故障間隔が二、五〇〇時間を超えるもの

1. Circulation type coolers, the average breakdown life or average breakdown interval of which exceeds 2,500 hours

(二) ジュールトムソン自己制御冷却器であって、直径が八ミリメートル未満のもの

2. Joule-Thompson self-regulating coolers having a diameter of less than 8 millimeters

七 センサー用の光ファイバーであって、音響、温度、加速度、電磁気又は放射線の測定用のもの

(vii) Optical fibers for use in sensors used to measure sound, temperature, acceleration, electromagnetism or radioactive rays

八 高速度の撮影が可能な映画撮影機、機械式のカメラ若しくはストリークカメラ若しくは電子式のカメラ又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの (第十一条に該当するものを除く。)

(viii) High speed cinema recording cameras, mechanical cameras, streak cameras, electronic cameras, or components thereof that fall under any of the following (excluding those falling under Article 11)

イ 次のいずれかに該当するもの

(a) Cameras which fall under any of the following

(一) 第三号ロに該当するイメージ増強管を組み込んだもの

1. Cameras with built-in image reinforcing tubes which fall under item (iii), (b)

(二) 第三号ホに該当するフォーカルプレーンアレーを組み込んだもの

2. Cameras with built-focal plane arrays which fall under item (iii), (e)

ロ 次のいずれかに該当するもの (イに該当するものを除く。)

(b) Cameras which fall under any of the following (excluding those which fall

under (a))

- (一) 映画撮影機であって、幅が八ミリメートル以上一六ミリメートル以下のフィルムを用いるもののうち、撮影速度が一秒につき一三、一五〇こまを超えるもの
1. Among cinema recording cameras which use film with a width of 8 millimeters or more and 16 millimeters or less, those with a photographing speed exceeding 13,150 frames per second
- (二) 機械式のものであって、画面の高さが三六ミリメートルのこまを撮影する場合の撮影速度が一秒につき一、〇〇〇、〇〇〇こまを超えるもの
2. Mechanical cameras, the photographing speed of which, when photographing a frame with a screen height of 36 millimeters, exceeds 1,000,000 frames per second
- (三) ストリークカメラであって、撮影速度が一〇ミリメートル毎マイクロ秒を超えるもの
3. Streak cameras, the photographing speed of which exceeds 10 millimeters per microsecond
- (四) 電子式のフレーミングカメラであって、撮影速度が一秒につき一、〇〇〇、〇〇〇こまを超えるもの
4. Electronic framing cameras, the shutter speed of which exceeds 1 million frames per second
- (五) 電子式カメラであって、次の1及び2に該当するもの
5. Electronic cameras which fall under the following i. and ii.
- 1 シャッター速度が一マイクロ秒未満のもの
- i. Electronic cameras in which shutter speed is less than 1 microsecond
- 2 信号の読出速度が一秒につき一二五こまを超えるもの
- ii. Electronic cameras in which signal read-out speed exceeds 125 frames per second
- (六) モジュール式の構造を有する映画撮影機、機械式のカメラ、ストリークカメラ、電子式のフレーミングカメラ又は電子式のカメラに使用することができるプラグインユニットであって、(三)から(五)までのいずれかに該当するものが有する機能に到達させることができるもの
6. Plugging units which are capable of being used in cinema recording cameras having a module type structure, mechanical cameras, streak cameras, electronic framing cameras or electronic cameras which are capable of carrying out the functions which fall under any of 3. through 5.
- (七) 固体撮像素子を組み込んだビデオカメラであって、一〇ナノメートル超三〇、〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもののうち、次の1から3までのいずれかに該当し、かつ、4から6までのいずれかに該当するもの
7. Among video cameras that incorporate solid-state image sensors having

a maximum sensitivity within a wavelength range exceeding 10 nanometer and 30,000 nanometers or less, those which fall under any of the following i. through iii. and also fall under any of the following iv. through vi.

- 1 白黒撮影用のものであって、固体撮像素子の有効画素数が四、〇〇〇、〇〇〇を超えるもの
- i. Video cameras used for black and white photography in which solid-state image sensor have exceeding 4,000,000 effective pixels
- 2 三の固体撮像素子を組み込んだカラー撮影用のものであって、それぞれの固体撮像素子の有効画素数が四、〇〇〇、〇〇〇を超えるもの
- ii. Video cameras used for color photography that incorporate three solid-state image sensors, in which the respective solid-state image sensor have exceeding 4,000,000 effective pixels
- 3 一の固体撮像素子を組み込んだカラー撮影用のものであって、当該固体撮像素子の有効画素数が一二、〇〇〇、〇〇〇を超えるもの
- iii. Video cameras for color photography that incorporate one solid-state image sensor, in which the solid-state image sensor have exceeding 12,000,000 effective pixels
- 4 第九号イに該当する反射鏡を有するもの
- iv. Video cameras having a reflector that fall under item (ix), (a)
- 5 第九号ニに該当する光学器械又は光学部品の制御装置を有するもの
- v. Video cameras having a control device having an optical device or optical components which fall under item (ix), (d)
- 6 カメラの被写体追跡データを内部処理して画像情報に注記できる機能を有するもの
- vi. Video cameras having a function which enables them to internally process tracking data for the object to be photographed by the camera and to record these in the image information
- (八) スキャニングカメラ又はスキャニングカメラ装置であって、次の1から3までのすべてに該当するもの
8. Scanning cameras or scanning camera equipment that fall under all of the following i. through iii.
- 1 一〇ナノメートル超三〇、〇〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの
- i. Scanning cameras or scanning camera equipment having a maximum sensitivity within a wavelength range exceeding 10 nanometers and 30,000 nanometers or less
- 2 画素が線状に並んだ固体撮像素子を組み込んだものであって、当該画素の数が、八、一九二を超えるもの
- ii. Scanning cameras or scanning camera equipment that incorporates solid-state image sensor in which the pixels are arrayed in a linear

fashion and the number of pixels is exceeding 8,192

3 一方向に機械的に走査を行うもの

iii. Scanning cameras or scanning camera equipment which scan mechanically in one direction

(九) 第三号ハ(一)に該当するイメージ増強管を組み込んだもの

9. Scanning cameras or scanning camera equipment with a built-in image reinforcing tube which fall under item (iii), (c), 1.

(十) 第三号ニに該当するフォーカルプレーンアレーを組み込んだもの

10. Scanning cameras or scanning camera equipment with a built-in focal plane array which falls under item (iii), (d)

九 光学器械又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの

(ix) Optical equipment or components thereof which fall under any of the following

イ 反射鏡であって、次のいずれかに該当するもの

(a) Reflectors which fall under any of the following

(一) 一〇〇ヘルツを超える周波数で鏡面の形状を変化させることができるもの又はその部分品

1. Reflectors which are capable of changing the shape of the mirror surface at frequencies exceeding 100 hertz, or components thereof

(二) 複合材料又は発泡体の部分を有していないものであって、鏡面の一平方メートル当たりの質量が三〇キログラム未満のもののうち、全重量が一〇キログラムを超えるもの

2. Among reflectors which do not have parts made of composite materials or foams, in which the mirror surface has a mass per square meter of less than 30 kilograms, those in which the total weight exceeds 10 kilograms

(三) 複合材料又は発泡体の部分を有するものであって、鏡面の一平方メートル当たりの質量が三〇キログラム未満のもののうち、全重量が二キログラムを超えるもの

3. Among reflectors which do have parts made of composite materials or foams, in which the mirror surface has a mass per square meter of less than 30 kilograms, those in which the total weight exceeds 2 kilograms

(四) 光の方向を制御するためのものであって、平面度が三一六・五ナノメートル以下のものうち、鏡面の直径又は長軸の長さが一〇〇ミリメートルを超え、かつ、制御の帯域幅が一〇〇ヘルツを超えるもの

4. Among reflectors used to control the direction of light and with a flatness of 316.5 nanometers or less, those in which the diameter of the mirror surface of which or the length of the major axis of which exceeds 100 millimeters, and in which control bandwidth exceeds 100 hertz

ロ セレン化亜鉛又は硫化亜鉛からなる光学部品であって、三、〇〇〇ナノメー

ル超二五、〇〇〇ナノメートル以下の波長の光を透過するもののうち、次のいずれかに該当するもの

(b) Among optical components made up of zinc selenide or zinc sulfide, which are permeable to light with a wavelength exceeding 3,000 nanometers and 25,000 nanometers or less, those which fall under any of the following

(一) 体積が一〇〇立方センチメートルを超えるもの

1. Optical components with a volume exceeding 100 cubic centimeter

(二) 直径又は長軸の長さが八〇ミリメートルを超え、かつ、厚さが二〇ミリメートルを超えるもの

2. Optical components, the diameter or major axis length of which exceeds 80 millimeters and the thickness of which exceeds 20 millimeters

ハ 宇宙用に設計した光学部品であって、次のいずれかに該当するもの

(c) Optical components designed for space use which fall under any of the following

(一) 全体が稠密な状態である場合に比し二〇パーセント未満の重量に軽量化したもの

1. Optical components which have been made lighter for weights which are less than 20 % compared to the condition of full density of the body.

(二) 基板（コーティングしたもの又は保護膜を有するものを含む。）

2. Substrates (including coating substrates or substrates having a protective film)

(三) 宇宙空間で組み立てるように設計した反射鏡であって、組み立てた場合の受光面積の和が口径一メートル以上の反射鏡と同等になるものの部分品

3. Reflectors which are designed so that they are capable of being assembled during space flight and components which are equivalent to reflecting mirrors the sum of the light receiving surface areas when assembled of which is an aperture greater than 1 meter

(四) すべての方向について線膨張係数が温度一度当たり一〇〇万分の五以下の複合材料からなるもの

4. Optical components made of composite materials, the linear coefficient of expansion in all directions of which is not more than 5/1,000,000 per degree of temperature

ニ 光学器械又は光学部品の制御装置であって、次のいずれかに該当するもの

(d) Controllers of optical equipment or components that fall under any of the following

(一) ハ (一) 又は (三) に該当する宇宙用に設計した光学部品の表面形状又は方向を維持するように設計したもの

1. Controllers which are designed to maintain the surface shape or direction of optical components which have been designed for space use which fall under (c) 1. or (c) 3.

(二) 一〇〇ヘルツ以上の帯域幅で光の走査、追尾若しくは安定化又は光共振

- 器の調整を行うものであって、その精度が一〇マイクロラジアン以下のもの
2. Optical components which are used to scan, track or stabilize light at bandwidths of 100 hertz or more or coordinate optical resonators, and the precision of which is 10 microradians or less
    - (三) 最大振れ角が五度を超え、かつ、一〇〇ヘルツ以上の帯域幅で 사용할ことができるジンバルであって、次のいずれかに該当するもの
  3. Gimbals with a maximum deflection angle exceeding 5 degrees, which are capable of being used in bandwidths of 100 hertz or more which fall under any of the following
    - 1 直径又は長軸の長さが〇・一五メートル超一メートル以下のものであって、角加速度が二ラジアン毎秒毎秒を超え、かつ、精度が二〇〇マイクロラジアン以下のもの
      - i. Gimbals with a length of diameter or major axis exceeding 0.15 meters and 1 meter or less, and with an angular acceleration exceeding 2 radians per second squared and with a precision of 200 microradians or less
      - 2 直径又は長軸の長さが一メートルを超えるものであって、角加速度が〇・五ラジアン毎秒毎秒を超え、かつ、精度が二〇〇マイクロラジアン以下のもの
      - ii. Gimbals with a length of diameter or major axis exceeding 1 meter, and with an angular acceleration exceeding 0.5 radians per second squared and with a precision of 200 microradians or less
    - (四) 直径又は長軸の長さが一メートル以上の反射鏡からなる光学系（反射光の位相を調整することができるものに限る。）の制御をするように設計したもの
  4. Controllers designed to control an optical system (limited to those which are capable of being used to adjust the phase of the reflecting mirror) made up of a reflector having a diameter or major axis length which is greater than 1 meter
- 九の二 非球面光学素子であって、次のイからハまでのすべてに該当するもの（第六条第十七号に該当するものを除く。）
- (ix)-2 Aspherical optical elements which fall under all of (a) through (c) (excluding those which fall under Article 6, item (xvii))
- イ 光学的開口の最大寸法が四〇〇ミリメートルを超えるもの
- (a) Aspherical optical elements, the maximum measurement for the optical aperture of which exceeds 400 millimeters
- ロ 一ミリメートル以上のサンプリング長さにおける表面粗さの二乗平均が一ナノメートル未満のもの
- (b) Aspherical optical elements having a root mean square surface roughness of less than 1 nanometer at a sampling length of 1 millimeter or more
- ハ 摂氏二五度の温度における線膨張係数の絶対値が一〇〇万分の三未満のもの

(c) Aspherical optical elements for which the absolute value of the linear coefficient of expansion at a temperature of 25 degrees centigrade is less than 3/1,000,000

十 レーザー発振器又はその部分品、附属品若しくは試験装置であつて、次のいずれかに該当するもの

(x) Laser oscillators or components thereof, accessories or test equipment that fall under any of the following

イ ガスレーザー発振器であつて、次のいずれかに該当するもの

(a) Gas laser oscillators which fall under any of the following

(一) エキシマーレーザー発振器であつて、次のいずれかに該当するもの（第六条第十七号に該当するものを除く。）

1. Excimer laser oscillators which fall under any of the following (excluding those which fall under Article 6, item (xvii))

1 一五〇ナノメートル以下の波長で使用するよう設計したものであつて、次のいずれかに該当するもの

i. Excimer laser oscillators which are designed for use at wavelengths of 150 nanometers or less and which fall under any of the following

一 一パルス当たり五〇ミリジュールを超えるパルスを発振するもの

a. Excimer laser oscillators which generate pulses exceeding 50 millijoules per pulse

二 平均出力が一ワットを超えるもの

b. Excimer laser oscillators the average output of which exceeds 1 watt

2 一五〇ナノメートル超一九〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するよう設計したものであつて、次のいずれかに該当するもの

ii. Excimer laser oscillators which are designed for use within a wavelength range exceeding 150 nanometers and 190 nanometers or less and which fall under any of the following

一 一パルス当たり一・五ジュールを超えるパルスを発振するもの

a. Excimer laser oscillators which generate pulses exceeding 1.5 joules per pulse

二 平均出力が一二〇ワットを超えるもの

b. Excimer laser oscillators the average output of which exceeds 120 watts

3 一九〇ナノメートル超三六〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するよう設計したものであつて、次のいずれかに該当するもの

iii. Excimer laser oscillators which are designed for use within a wavelength range exceeding 190 nanometers and 360 nanometers or more and which fall under any of the following

一 一パルス当たり一〇ジュールを超えるパルスを発振するもの

a. Excimer laser oscillators which generate pulses exceeding 10 joules per pulse



- 二 平均出力が五〇〇ワットを超えるもの
- b. Excimer laser oscillators the average output of which exceeds 500 watts
  - 4 三六〇ナノメートルを超える波長で使用するよう設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
  - iv. Excimer laser oscillators which are designed for use at wavelengths exceeding 360 nanometers and which fall under any of the following
    - 一 一パルス当たり一・五ジュールを超えるパルスを発振するもの
    - a. Excimer laser oscillators which generate pulses exceeding 1.5 joules per pulse
      - 二 平均出力が三〇ワットを超えるもの
      - b. Excimer laser oscillators the average output of which exceeds 30 watts
- (二) 金属蒸気レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの
- 2. Metal vapor laser oscillators which fall under any of the following
  - 1 銅レーザー発振器であって、平均出力が二〇ワットを超えるもの
  - i. Copper laser oscillators the average output of which exceeds 20 watts
  - 2 金レーザー発振器であって、平均出力が五ワットを超えるもの
  - ii. Metal laser oscillators the average output of which exceeds 5 watts
  - 3 ナトリウムレーザー発振器であって、定格出力が五ワットを超えるもの
  - iii. Sodium laser oscillators the rated output of which exceeds 5 watts
  - 4 バリウムレーザー発振器であって、平均出力が二ワットを超えるもの
  - iv. Barium laser oscillators the average output of which exceeds 2 watts
- (三) 一酸化炭素レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの
- 3. Carbon monoxide laser oscillators which fall under any of the following
  - 1 一パルス当たり二ジュールを超えるパルスを発振し、かつ、パルスのピーク出力が五キロワットを超えるもの
  - i. Carbon monoxide laser oscillators which generate pulses exceeding 2 joules per pulse and the pulse peak output of which exceeds 5 kilowatts
  - 2 平均出力又は持続波の定格出力が五キロワットを超えるもの
  - ii. Carbon monoxide laser oscillators the average output of which or the continuous wave rated output of which exceeds 5 kilowatts
- (四) 二酸化炭素レーザー発振器（ふっ化重水素からの励起移動によって励起するように設計したものを除く。）であって、次のいずれかに該当するもの
- 4. Carbon dioxide laser oscillators (excluding those designed to excite by excitation transfer from deuterium fluoride) which fall under any of the following
  - 1 持続波の定格出力が一五キロワットを超えるもの
  - i. Carbon dioxide laser oscillators the continuous wave rated output of which exceeds 15 kilowatts
  - 2 一〇マイクロ秒を超えるパルス幅のパルスを発振するものであって、次の

- いずれかに該当するもの
- ii. Carbon dioxide laser oscillators which generate pulses with a pulse width exceeding 10 microseconds and which fall under any of the following
    - 一 平均出力が一〇キロワットを超えるもの
    - a. Carbon dioxide laser oscillators with an average output exceeding 10 kilowatts
    - 二 パルスのピーク出力が一〇〇キロワットを超えるもの
    - b. Carbon dioxide laser oscillators with a pulse peak output exceeding 100 kilowatts
    - 三 一〇マイクロ秒以下のパルス幅のパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
  - iii. Carbon dioxide laser oscillators which generate pulses with a pulse width of 10 microseconds or less and which fall under the following
    - 一 一パルス当たり五ジュールを超えるパルスを発振するもの
    - a. Carbon dioxide laser oscillators which generate pulses exceeding 5 joules per pulse
    - 二 平均出力が二・五キロワットを超えるもの
    - b. Carbon dioxide laser oscillators the average output of which exceeds 2.5 kilowatts
- (五) 化学レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの
5. Chemical laser oscillators which fall under any of the following
- 1 ふっ化水素レーザー発振器
    - i. Hydrogen fluoride laser oscillators
    - 2 ふっ化重水素レーザー発振器
    - ii. Deuterium fluoride laser oscillators
    - 3 トランスファーレーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの
  - iii. Transfer laser oscillators which fall under any of the following
    - 一 酸素からの励起移動によって励起するように設計したよう素レーザー発振器
    - a. Iodine laser oscillators which are designed so that they are capable of being excited by excitation transfer from oxygen
    - 二 ふっ化重水素からの励起移動によって励起するように設計した二酸化炭素レーザー発振器
    - b. Carbon dioxide laser oscillators which are designed to be excited by excitation transfer from deuterium fluoride
- (六) クリプトンイオンレーザー発振器又はアルゴンイオンレーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの
6. Krypton ion laser oscillators or argon ion laser oscillators which fall under any of the following
- 1 一パルス当たり一・五ジュールを超えるパルスを発振し、かつ、パルスの

ピーク出力が五〇ワットを超えるもの

i. Krypton ion laser oscillators or argon ion laser oscillators which generate pulses exceeding 1.5 joules per pulse and the pulse peak output of which exceeds 50 watts

2 平均出力又は持続波の定格出力が五〇ワットを超えるもの

ii. Krypton ion laser oscillators or argon ion laser oscillators the average output or continuous wave rated output of which exceeds 50 watts

(七) エキシマーレーザー発振器、銅レーザー発振器、金レーザー発振器、ナトリウムレーザー発振器、バリウムレーザー発振器、一酸化炭素レーザー発振器、二酸化炭素レーザー発振器、ふっ化水素レーザー発振器、ふっ化重水素レーザー発振器、酸素からの励起移動によって励起するように設計したよう素レーザー発振器、クリプトンイオンレーザー発振器、アルゴンイオンレーザー発振器又は窒素レーザー発振器以外のガスレーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの

7. Excimer laser oscillators, copper laser oscillators, metal laser oscillators, sodium laser oscillators, barium laser oscillators, carbon monoxide laser oscillators, carbon dioxide laser oscillators, hydrogen fluoride laser oscillators, deuterium fluoride oscillators, and laser oscillators designed to be excited by excitation transfer from oxygen, krypton ion laser oscillators, argon laser oscillators and gas laser oscillators other nitrogen laser oscillators which fall under any of the following

1 一五〇ナノメートル以下の波長で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの

i. Laser oscillators which are designed for use at wavelengths of 150 nanometers or less and which fall under any of the following

一 一パルス当たり五〇ミリジュールを超えるパルスを発振し、かつ、パルスのピーク出力が一ワットを超えるもの

a. Laser oscillators which generate pulses exceeding 50 millijoules per pulse and the pulse peak output of which exceeds 1 watt

二 平均出力又は持続波の定格出力が一ワットを超えるもの

b. Those the average output or continuous wave rated output of which exceeds 1 watt

2 一五〇ナノメートル超八〇〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの

ii. Laser oscillators which are designed for use within a wavelength range exceeding 150 nanometers and 800 nanometers or less and which fall under any of the following

一 一パルス当たり一・五ジュールを超えるパルスを発振し、かつ、パルスのピーク出力が三〇ワットを超えるもの

a. Laser oscillators which generate pulses exceeding 1.5 joules per pulse and with a pulse peak output exceeding 30 watts

- 二 平均出力又は持続波の定格出力が三〇ワットを超えるもの
- b. Laser oscillators with an average output or a rated output of continuous wave exceeding 30 watts
- 3 八〇〇ナノメートル超一、四〇〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するよう設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
- iii. Laser oscillators which are designed for use within a wavelength range exceeding 800 nanometers and 1,400 nanometers or less that fall under any of the following
- 一 一パルス当たり〇・二五ジュールを超えるパルスを発振し、かつ、パルスのピーク出力が一〇ワットを超えるもの
- a. Laser oscillators which generate pulses exceeding 0.25 joules per pulse and the pulse peak output of which exceeds 10 watts
- 二 平均出力又は持続波の定格出力が一〇ワットを超えるもの
- b. Laser oscillators the average output or continuous wave rated output of which exceeds 10 watts
- 4 一、四〇〇ナノメートルを超える波長で使用するよう設計したものであって、平均出力又は持続波の定格出力が一ワットを超えるもの
- iv. Laser oscillators which are designed for use at wavelengths exceeding 1,400 nanometers and the average output or continuous wave rated output of which exceeds 1 watt
- ロ 半導体レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの
- (b) Semiconductor laser oscillators which fall under any of the following
- (一) 単一横モード半導体レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの
- 1. Single transverse mode semiconductor laser oscillators which fall under any of the following
- 1 一、五一〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するよう設計したもののうち、平均出力又は持続波の定格出力が一・五ワットを超えるもの
- i. Among single transverse mode semiconductor laser oscillators which are designed for use within a wavelength range of 1,510 nanometers or less, those with an average output or continuous wave rated output exceeding 1.5 watts
- 2 一、五一〇ナノメートルを超える波長範囲で使用するよう設計したもののうち、平均出力又は持続波の定格出力が五〇〇ミリワットを超えるもの
- ii. Among single transverse mode semiconductor laser oscillators which are designed for use within a wavelength range exceeding 1,510 nanometers, those with an average output or continuous wave rated output exceeding 500 milliwatts
- (二) 多重横モード半導体レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの
- 2. Multiple transverse mode semiconductor laser oscillators which fall

under any of the following

- 1 一、四〇〇ナノメートル未満の波長範囲で使用するよう設計したもののうち、平均出力又は持続波の定格出力が一〇ワットを超えるもの
    - i. Among multiple transverse mode semiconductor laser oscillators which are designed for use within a wavelength range of less than 1,400 nanometers, those with an average output or continuous wave rated output exceeding 10 watts
  - 2 一、四〇〇ナノメートル以上一、九〇〇ナノメートル未満の波長範囲で使用するよう設計したもののうち、平均出力又は持続波の定格出力が二・五ワットを超えるもの
    - ii. Among multiple transverse mode semiconductor laser oscillators which are designed for use within a wavelength range of 1,400 nanometers or more and less than 1,900 nanometers, those with an average output or continuous wave rated output exceeding 2.5 watts
  - 3 一、九〇〇ナノメートル以上の波長範囲で使用するよう設計したもののうち、平均出力又は持続波の定格出力が一ワットを超えるもの
    - iii. Among multiple transverse mode semiconductor laser oscillators which are designed for use within a wavelength range of 1,900 nanometers or more, those with an average output or continuous wave rated output exceeding 1 watt
- (三) 半導体レーザー発振器を集積化した半導体レーザーアレーであって、次のいずれかに該当するもの
3. Semiconductor laser arrays with integrated semiconductor laser oscillators that fall under any of the following
    - 1 一、四〇〇ナノメートル未満の波長範囲で使用するよう設計したもののうち、平均出力又は持続波の定格出力が八〇ワットを超えるもの
      - i. Among semiconductor laser arrays with integrated semiconductor laser oscillators which are designed for use within a wavelength range of less than 1,400 nanometers, those with an average output or continuous wave rated output exceeding 80 watts
    - 2 一、四〇〇ナノメートル以上一、九〇〇ナノメートル未満の波長範囲で使用するよう設計したもののうち、平均出力又は持続波の定格出力が二五ワットを超えるもの
      - ii. Among semiconductor laser arrays with integrated semiconductor laser oscillators which are designed for use within a wavelength range of 1,400 nanometers or more and less than 1,900 nanometer, those with an average output or continuous wave rated output exceeding 25 watts
    - 3 一、九〇〇ナノメートル以上の波長範囲で使用するよう設計したもののうち、平均出力又は持続波の定格出力が一〇ワットを超えるもの
      - iii. Among semiconductor laser arrays with integrated semiconductor

laser oscillators which are designed for use within a wavelength range of 1,900 nanometers or more, those with an average output or a continuous wave rated output exceeding 10 watts

(四) 半導体レーザーアレースタックであって、(三)に該当するアレーを含むもの

4. Semiconductor laser array stacks which include the arrays falling under 3. above

ハ 固体レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの

(c) Solid-state laser oscillators which fall under the following

(一) 波長可変レーザー発振器(チタンサファイアレーザー発振器、ツリウムワイエジーレーザー発振器、ツリウムワイエスジージーレーザー発振器、アレキサンドライトレーザー発振器又はカラーセンターレーザー発振器を含む。(二)において同じ。)であって、次のいずれかに該当するもの

1. Variable wavelength oscillators (including titanium sapphire laser oscillators, thulium YAG laser oscillators, thulium YSGG laser oscillators, alexandrite laser oscillators or color center laser oscillators; the same shall apply in 2.) which fall under any of the following

1 六〇〇ナノメートル未満の波長で使用するよう設計したものであって、次のいずれかに該当するもの

i. Variable wavelength oscillators which are designed for use at wavelengths of less than 600 nanometers and which fall under any of the following

一 一パルス当たり五〇ミリジュールを超えるパルスを発振し、かつ、パルスのピーク出力が一ワットを超えるもの

a. Variable wavelength oscillators which generate pulses exceeding 50 millijoules per pulse and the pulse peak output of which exceeds 1 watt

二 平均出力又は持続波の定格出力が一ワットを超えるもの

b. Variable wavelength oscillators, the average output or continuous wave rated output of which exceeds 1 watt

2 六〇〇ナノメートル以上一、四〇〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するよう設計したものであって、次のいずれかに該当するもの

ii. Variable wavelength oscillators which are designed for use within a wavelength range of 600 nanometers or more and 1,400 nanometers or less and which fall under any of the following

一 一パルス当たり一ジュールを超えるパルスを発振し、かつ、パルスのピーク出力が二〇ワットを超えるもの

a. Variable wavelength oscillators which generate pulses exceeding 1 joule per pulse and the pulse peak output of which exceeds 20 watts

二 平均出力又は持続波の定格出力が二〇ワットを超えるもの

b. Variable wavelength oscillators, the average output or continuous

- wave rated output of which exceeds 20 watts
- 3 一、四〇〇ナノメートルを超える波長で使用するよう設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
- iii. Variable wavelength oscillators which are designed for use at wavelengths exceeding 1,400 nanometers and which fall under any of the following
- 一 一パルス当たり五〇ミリジュールを超えるパルスを発振し、かつ、パルスのピーク出力が一ワットを超えるもの
- a. Variable wavelength oscillators which generate pulses exceeding 50 millijoules per pascal the pulse peak output of which exceeds 1 watt
- 二 平均出力又は持続波の定格出力が一ワットを超えるもの
- b. Variable wavelength oscillators, the average output or continuous wave rated output of which for which exceeds 1 watt
- (二) 波長可変レーザー発振器以外の固体レーザー発振器（アトミックトランジション固体レーザー発振器を含む。）であって、次のいずれかに該当するもの
2. Solid-state laser oscillators other than variable wavelength laser oscillators (including atomic transition solid state laser oscillators) which fall under any of the following
- 1 ネオジウムガラスレーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの
- i. Neodymium glass laser oscillators which fall under any of the following
- 一 キュースイッチを用いたものであって、次のいずれかに該当するもの
- a. Neodymium glass laser oscillators which use Q switches and which fall under any of the following
- イ 一パルス当たり二〇ジュール超五〇ジュール以下のパルスを発振し、かつ、平均出力が一〇ワットを超えるもの
- 1 Neodymium glass laser oscillators which generate pulses exceeding 20 joules per pulse and 50 joules or less and with an average output exceeding 10 watts
- ロ 一パルス当たり五〇ジュールを超えるパルスを発振するもの
- 2 Neodymium glass laser oscillators which generate pulses exceeding 50 joules per pulse
- 二 キュースイッチを用いていないものであって、次のいずれかに該当するもの
- b. Neodymium glass laser oscillators which do not use Q switches and which fall under any of the following
- イ 一パルス当たり五〇ジュール超一〇〇ジュール以下のパルスを発振し、かつ、平均出力が二〇ワットを超えるもの
- 1 Neodymium glass laser oscillators which generate pulses exceeding 50 joules per pulse and 100 joules or less and with an average output exceeding 20 watts

- ロ 一パルス当たり一〇〇ジュールを超えるパルスを発振するもの
- 2 Neodymium glass laser oscillators which generate pulses exceeding 100 joules per pulse
  - 2 一、〇〇〇ナノメートル超一、一〇〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したネオジウムを添加した固体レーザー発振器（ネオジウムガラスレーザー発振器を除く。）であって、次のいずれかに該当するもの
- ii. Solid-state laser oscillators (excluding neodymium glass laser oscillators) with added neodymium which are designed for use within a wavelength range exceeding 1,000 nanometers and 1,100 nanometers or less and which fall under any of the following
  - 一 パルス励起、キュースイッチ及びモード同期を用いたものであって、一ナノ秒未満のパルス幅のパルスを発振するもののうち、次のいずれかに該当するもの
    - a. Among solid-state laser oscillators which use pulse excitation, Q switch and mode synchronization, and which generate pulses with a pulse width of less than 1 nanosecond, those which fall under any of the following
      - イ パルスのピーク出力が五ギガワットを超えるもの
      - 1 Solid-state laser oscillators, the pulse peak output of which exceeds 5 gigawatts
      - ロ 平均出力が一〇ワットを超えるもの
      - 2 Solid-state laser oscillators, the average output of which exceeds 10 watts
      - ハ 一パルス当たり〇・一ジュールを超えるパルスを発振するもの
    - 3 Solid-state laser oscillators which generate pulses exceeding 0.1 joules per pulse
      - 二 パルス励起及びキュースイッチを用いたものであって、一ナノ秒以上のパルス幅のパルスを発振するもののうち、次のいずれかに該当するもの
  - b. Among solid-state laser oscillators which use pulse excitation and Q switches, and which generate pulses with a pulse width greater than 1 nanosecond, those which fall under any of the following
    - イ 単一横モードのパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
      - 1 Solid-state laser oscillators which generate single transverse mode pulses and which fall under any of the following
        - (一) パルスのピーク出力が一〇〇メガワットを超えるもの
    - i) Solid-state laser oscillators, the pulse peak output of which exceeds 100 megawatts
      - (二) 平均出力が二〇ワットを超えるもの
  - ii) Solid-state laser oscillators, the average output of which exceeds 20 watts



- (三) 一パルス当たり二ジュールを超えるパルスを発振するもの
- iii) Solid-state laser oscillators which generate pulses which exceed 2 joules per pulse
- ロ 多重横モードのパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
- 2 Solid-state laser oscillators which generate multiple transverse mode pulses and which fall under any of the following
  - (一) パルスのピーク出力が四〇〇メガワットを超えるもの
  - i) Solid-state laser oscillators, the pulse peak output of which exceeds 400 megawatts
  - (二) 平均出力が二キロワットを超えるもの
  - ii) Solid-state laser oscillators, the average output of which exceeds 2 kilowatts
  - (三) 一パルス当たり二ジュールを超えるパルスを発振するもの
  - iii) Solid-state laser oscillators which generate pulses exceeding 2 joules per pulse
  - 三 パルス励起を用い、かつ、キュースイッチを用いていないものであって、次のいずれかに該当するもの
  - c. Solid-state laser oscillators which use pulse excitation and do not use Q switches and which fall under any of the following
  - イ 単一横モードのパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
  - 1 Solid-state laser oscillators which generate single transverse mode pulses and which fall under any of the following
    - (一) パルスのピーク出力が五〇〇キロワットを超えるもの
    - i) Solid-state laser oscillators, the pulse peak output of which exceeds 500 kilowatts
    - (二) 平均出力が一五〇ワットを超えるもの
    - ii) Solid-state laser oscillators, the average output of which exceeds 150 watts
    - ロ 多重横モードのパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
    - 2 Solid-state laser oscillators which generate multiple transverse mode pulses and which fall under any of the following
      - (一) パルスのピーク出力が一メガワットを超えるもの
      - i) Solid-state laser oscillators, the pulse peak output of which exceeds 1 megawatt
      - (二) 平均出力が二キロワットを超えるもの
      - ii) Solid-state laser oscillators, the average output of which exceeds 2 kilowatts
      - 四 連続励起を用いたものであって、次のいずれかに該当するもの

d. Solid-state laser oscillators which use continuous excitation and which fall under any of the following

イ 単一横モードのパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの

1 Solid-state laser oscillators which generate single transverse mode pulses and which fall under any of the following

(一) パルスのピーク出力が五〇〇キロワットを超えるもの

i) Solid-state laser oscillators, the pulse peak output of which exceeds 500 kilowatts

(二) 平均出力又は持続波の定格出力が一五〇ワットを超えるもの

ii) Solid-state laser oscillators, the average output or continuous wave rated output of which exceeds 150 watts

ロ 多重横モードのパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの

2 Solid-state laser oscillators which generate multiple transverse mode pulses and which fall under any of the following

(一) パルスのピーク出力が一メガワットを超えるもの

i) Solid-state laser oscillators, the pulse peak output of which exceeds 1 megawatt

(二) 平均出力又は持続波の定格出力が二キロワットを超えるもの

ii) Solid-state laser oscillators, the average output or continuous wave rated output of which exceeds 2 kilowatts

3 ネオジウムガラスレーザー発振器又はネオジウムを添加した固体レーザー発振器（一、〇〇〇ナノメートル超一、一〇〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するよう設計したものに限る。）以外のものであって、次のいずれかに該当するもの

iii. Solid-state laser oscillators other than neodymium glass laser oscillators or solid state laser oscillators with added neodymium (limited to those designed for use within a wavelength range exceeding 1,000 nanometers and 1,100 nanometers or less.) which fall under any of the following

一 一五〇ナノメートル未満の波長で使用するよう設計したものであって、次のいずれかに該当するもの

a. Solid-state laser oscillators which are designed for use at wavelengths of less than 150 nanometers and which fall under any of the following

イ 一パルス当たり五〇ミリジュールを超えるパルスを発振し、かつ、パルスのピーク出力が一ワットを超えるもの

1 Solid-state laser oscillators which generate pulses exceeding 50 millijoules per pulse, and the pulse peak output of which exceeds 1 watt

- ロ 平均出力又は持続波の定格出力が一ワットを超えるもの
- 2 Solid-state laser oscillators, the average output or continuous wave rated output of which exceeds 1 watt.
- 二 一五〇ナノメートル以上八〇〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するよう設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
  - b. Solid-state laser oscillators which are designed for use within a wavelength range of 150 nanometers or more and 800 nanometers or less and which fall under any of the following
    - イ 一パルス当たり一・五ジュールを超えるパルスを発振し、かつ、パルスのピーク出力が三〇ワットを超えるもの
      - 1 Solid-state laser oscillators which generate pulses exceeding 1.5 joules per pulse, and the pulse peak output of which exceeds 30 watts
      - ロ 平均出力又は持続波の定格出力が三〇ワットを超えるもの
      - 2 Solid-state laser oscillators, the average output or continuous wave rated output of which exceeds 30 watts
      - 三 八〇〇ナノメートル超一、四〇〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するよう設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
    - c. Solid-state laser oscillators which are designed for use within a wavelength range exceeding 800 nanometers and 1,400 nanometers or less and which fall under any of the following
      - イ キュースイッチを用いたものであって、次のいずれかに該当するもの
        - 1 Solid-state laser oscillators which use Q switches and which fall under any of the following
          - (一) 一パルス当たり〇・五ジュールを超えるパルスを発振し、かつ、パルスのピーク出力が五〇ワットを超えるもの
        - i) Solid-state laser oscillators which generate pulses exceeding 0.5 Joules per pulse, and the pulse peak output of which exceeds 50 watts
          - (二) 単一横モードの平均出力が一〇ワットを超えるもの
        - ii) Solid-state laser oscillators, the single transverse mode average output of which exceeds 10 watts
          - (三) 多重横モードの平均出力が三〇ワットを超えるもの
        - iii) Solid-state laser oscillators, the multiple transverse mode average output of which exceeds 30 watts
      - ロ キュースイッチを用いていないものであって、次のいずれかに該当するもの
        - 2 Solid-state laser oscillators which do not use Q switches and which fall under any of the following
          - (一) 一パルス当たり二ジュールを超えるパルスを発振し、かつ、パルスのピーク出力が五〇ワットを超えるもの
        - i) Solid-state laser oscillators which generate pulses exceeding 2 joules per pulse and the pulse peak output of which exceeds 50 watts

- (二) 平均出力又は持続波の定格出力が五〇ワットを超えるもの
- ii) Solid-state laser oscillators, the average output or continuous wave rated output of which exceeds 50 watts
- 四 一、四〇〇ナノメートルを超える波長で使用するよう設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
- d. Solid-state laser oscillators which are designed for use at wavelengths exceeding 1,400 nanometers and which fall under any of the following
  - イ 一パルス当たり一〇〇ミリジュールを超えるパルスを発振し、かつ、パルスのピーク出力が一ワットを超えるもの
  - 1 Solid-state laser oscillators which generate pulses exceeding 100 millijoules per pulse, and the pulse peak output of which exceeds 1 watt
  - ロ 平均出力又は持続波の定格出力が一ワットを超えるもの
  - 2 Solid-state laser oscillators, the average output or continuous wave rated output of which exceeds 1 watt
- ニ 液体レーザー発振器（色素レーザー発振器を含む。）であって、次のいずれかに該当するもの
- (d) Liquid laser oscillators (including dye laser oscillators) which fall under any of the following
  - (一) 一五〇ナノメートル未満の波長で使用するよう設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
  - 1. Liquid laser oscillators which are designed for use at wavelengths of less than 150 nanometers and which fall under any of the following
    - 1 一パルス当たり五〇ミリジュールを超えるパルスを発振し、かつ、パルスのピーク出力が一ワットを超えるもの
    - i. Liquid laser oscillators which generate pulses exceeding 50 millijoules per pulse and the pulse peak output of which exceeds 1 watt
    - 2 平均出力又は持続波の定格出力が一ワットを超えるもの
    - ii. Liquid laser oscillators, the average output or continuous wave rated output of which exceeds 1 watt
  - (二) 一五〇ナノメートル以上八〇〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するよう設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
  - 2. Liquid laser oscillators which are designed for use within a wavelength range of 150 nanometers or more and 800 nanometers or less and which fall under any of the following
    - 1 一パルス当たり一・五ジュールを超えるパルスを発振し、かつ、パルスのピーク出力が二〇ワットを超えるもの
    - i. Liquid laser oscillators which generate pulses exceeding 1.5 joules per pulse, and the pulse peak output of which exceeds 20 watts
    - 2 平均出力又は持続波の定格出力が二〇ワットを超えるもの

- ii. Liquid laser oscillators, the average output or continuous wave rated output of which exceeds 20 watts
- 3 平均出力が一ワットを超える単一縦モードのパルスを発振するものであって、パルス幅が一〇〇ナノ秒未満の場合にパルス繰返し周波数が一キロヘルツを超えるもの
- iii. Liquid laser oscillators which generate single transverse mode pulses the average output of which exceeds 1 watt and the pulse repetition frequency of which when the pulse width is less than 100 nanoseconds exceeds 1 kilohertz
- (三) 八〇〇ナノメートル超一、四〇〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するよう設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
- 3. Liquid laser oscillators which are designed for use within a wavelength range exceeding 800 nanometers and 1,400 nanometers or less which fall under any of the following
  - 1 一パルス当たり〇・五ジュールを超えるパルスを発振し、かつ、パルスのピーク出力が一〇ワットを超えるもの
    - i. Liquid laser oscillators which generate pulses exceeding 0.5 joules per pulse, and the pulse peak output of which exceeds 10 watts
    - 2 平均出力又は持続波の定格出力が一〇ワットを超えるもの
    - ii. Liquid laser oscillators, the average output or continuous wave rated output of which exceeds 10 watts
  - (四) 一、四〇〇ナノメートルを超える波長で使用するよう設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
  - 4. Liquid laser oscillators which are designed for use at wavelengths exceeding 1,400 nanometers and which fall under any of the following
    - 1 一パルス当たり一〇〇ミリジュールを超えるパルスを発振し、かつ、パルスのピーク出力が一ワットを超えるもの
      - i. Liquid laser oscillators which generate pulses exceeding 100 millijoules per pulse, the pulse peak output of which exceeds 1 watt
      - 2 平均出力又は持続波の定格出力が一ワットを超えるもの
      - ii. Liquid laser oscillators, the average output or continuous wave rated output of which exceeds 1 watt
- ホ レーザー発振器の部分品であって、次のいずれかに該当するもの
- (e) Components for laser oscillators which fall under any of the following
  - (一) 反射鏡であって、ヒートパイプを用いることにより又は鏡面下一ミリメートル未満の位置に流体を流すことにより冷却するよう設計したもの
  - 1. Reflectors which are designed for cooling by using a heat pipe or by passing a fluid at a position which is less than 1 millimeter beneath the surface of the mirror
  - (二) 反射鏡又は透過性を有する（部分的に透過する場合を含む。）光学部品若しくは電気光学部品であって、イからニまでのいずれかに該当するレーザ

一発振器に使用するよう設計したもの

2. Reflectors, or optical components or electro-optical components which are permeable (including partially permeable), and which are designed for use in laser oscillators which fall under any of (a) through (d)

へ レーザー発振器の試験装置又は附属品であつて、次のいずれかに該当するもの

- (f) Test equipment or accessories for laser oscillators which fall under any of the following

(一) 波面測定装置であつて、レーザー光の波面の位相を五〇箇所以上測定することができるもののうち、次のいずれかに該当するもの

1. Among equipment for measuring wave surface which is capable of measuring the phase of a wave surface of laser light at 50 or more locations, those that fall under any of the following

1 フレーム速度が一〇〇ヘルツ以上で、かつ、位相識別能がレーザー光の波長の五パーセント以下のもの

i. Equipment for measuring wave surface with a frame speed of 100 hertz or more and with a phase identification capability of 5 % or less of the wavelength of the laser light

2 フレーム速度が一、〇〇〇ヘルツ以上で、かつ、位相識別能がレーザー光の波長の二〇パーセント以下のもの

ii. Equipment for measuring wave surface with a frame speed of 1,000 hertz or more and with a phase identification capability of 20 % or less of the wavelength of the laser light

(二) レーザー発振器の試験装置であつて、超高出力レーザー発振器（五〇ミリ秒間に一キロジュールを超えるエネルギーを出力できる又は平均出力若しくは持続波の定格出力が二〇キロワットを超えるレーザー発振器をいう。以下同じ。）のビームの振れ角の一〇マイクロラジアン以下の誤差を測定することができるもの

2. Test equipment for laser oscillators which is capable of measuring errors in the beam deflection angle of an ultra-high output laser oscillator (laser oscillators which are capable of output energy exceeding 1 kilojoule per 50 milliseconds or the average output or continuous wave rated output of which exceeds 20 kilowatts; the same shall apply hereinafter) of less than 10 microradians

(三) フェーズドアレイ型の超高出力レーザー発振器の附属品であつて、使用する波長の一〇分の一又は〇・一マイクロメートル以下の精度でコヒーレント光を合成するためのもの

3. Accessories for phased array type ultra-high output laser oscillators which synthesize coherent light at 1/10 of the wavelength used or at a precision of 0.1 micrometers or less

(四) プロジェクションテレスコープであつて、超高出力レーザー発振器と組み合わせて使用するよう設計したもの

4. Projection telescopes which are designed for use in combination with ultra-high output laser oscillators

十一 磁力計若しくは磁場勾配計若しくはこれらの校正装置又はこれらの部分品であつて、次のいずれかに該当するもの（医療用に設計したものを除く。）

(xi) Magnetometers or magnetic gradiometers or calibration equipment or components thereof which fall under any of the following (excluding those designed for medical purposes)

イ 超電導の技術を利用した磁力計であつて、次のいずれかに該当するもの

(a) Magnetometers which utilize superconducting technology which fall under any of the following

(一) 静止状態で操作するように設計したものであつて、運動中に生じるノイズを減少させるために設計した装置を有しないもののうち、一ヘルツの周波数においてノイズレベル（帯域周波数の平方根当たりで表した実効値をいう。以下同じ。）が五〇フェムトテスラ以下のもの

1. Among magnetometers which utilize superconducting technology designed so that they are capable of being operated in a stationary state, not having a device which is designed to reduce noise occurring during operations, those for which the noise level at a 1 hertz frequency (the effective value indicated per square root of the band frequency; the same shall apply hereinafter) is 50 femtoteslas or less

(二) 運動中に生じるノイズを減少させるために設計した装置を有するものであつて、一ヘルツの周波数において運動中のノイズレベルが二〇ピコテスラ未満のもの

2. Magnetometers which utilize superconducting technology having a device designed to reduce noise occurring during operations, the noise level at a 1 hertz frequency of which is less than 20 picoteslas

ロ 光ポンプ又は核磁気共鳴の技術を利用した磁力計であつて、ノイズレベルが二ピコテスラ未満のもの

(b) Magnetometers which utilize an optical pump or nuclear magnetic resonance technology, the noise level of which is less than 2 picoteslas

ハ 光ポンプ又は核磁気共鳴の技術を利用した磁力計であつて、ノイズレベルが二ピコテスラ以上二〇ピコテスラ未満のもの

(c) Magnetometers which utilize an optical pump or nuclear magnetic resonance technology, the noise level of which is 2 picoteslas or more and less than 20 picoteslas

ニ 三軸フラックスゲートの技術を利用した磁力計であつて、一ヘルツの周波数においてノイズレベルが一〇ピコテスラ以下のもの

(d) Magnetometers which utilize triaxial flux gate technology, the noise level at 1 hertz frequency of which is 10 picoteslas or less

ホ 誘導コイルを用いた磁力計であつて、次のいずれかに該当するもの

(e) Magnetometers using an induction coil which fall under any of the

following

- (一) 一ヘルツ未満の周波数におけるノイズレベルが〇・〇五ナノテスラ未満のもの
1. Magnetometers which use an induction coil, the noise level at a frequency of less than 1 hertz of which is less than 0.05 nanoteslas
- (二) 一ヘルツ以上一〇ヘルツ以下の周波数におけるノイズレベルが〇・〇〇一ナノテスラ未満のもの
2. Magnetometers which use an induction coil, the noise level at frequencies of 1 hertz or more and 10 hertz or less of which is less than 0.001 nanoteslas
- (三) 一〇ヘルツを超える周波数におけるノイズレベルが〇・〇〇〇一ナノテスラ未満のもの
3. Magnetometers which use an induction coil, the noise level at frequencies exceeding 10 hertz of which is less than 0.0001 nanoteslas
- へ 光ファイバーを用いた磁力計であって、ノイズレベルが一ナノテスラ未満のもの
- (f) Magnetometers which use optical fiber, the noise level of which is less than 1 nanoteslas
- ト 磁場勾配計であって、イからへまでのいずれかに該当する磁力計を二以上用いたもの
- (g) Magnetic gradiometers using two or more magnetometers which fall under any of (a) through (f) above
- チ 光ファイバーを用いた磁場勾配計であって、イントリンシック型のもの（一軸当たりの検出素子の数が一のものをいう。以下この号において同じ。）のうち、ノイズレベルが〇・三ナノテスラ毎メートル未満のもの
- (h) Among magnetic gradiometers which use optical fibers and intrinsic type gradiometers (those having a single detection element per axle; hereinafter the same shall apply in this item), those the noise level of which is less than 0.3 nanoteslas per meter
- リ 光ファイバーを用いていない磁場勾配計であって、イントリンシック型のものうち、ノイズレベルが〇・〇一五ナノテスラ毎メートル未満のもの
- (i) Among magnetic gradiometers which do not use optical fibers and which are intrinsic gradiometers, those the noise level of which is less than 0.015 nanoteslas per meter
- ヌ 磁力計又は磁場勾配計の校正装置であって、車両、船舶、航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体に搭載するように設計したもののうち、地球の磁場の絶対値のみを出力とするもの
- (j) Among calibration equipment for magnetometers or magnetic gradiometers which are designed to be mounted on vehicles, vessels, aircraft or satellites and other types of spacecraft for space development, those having output only for the absolute value of terrestrial magnetic



fields

ル 磁力計又は磁場勾配計の校正装置であって、車両、船舶、航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体に搭載するように設計したもの（又該当するものを除く。）

(k) Calibration equipment for magnetometers or magnetic gradiometers which are designed to be mounted on vehicles, vessels, aircraft or satellites and other types of spacecraft for space development (excluding those falling under (j))

十二 重力計であって、次のいずれかに該当するもの又は重力勾配計

(xii) Gravity meters that fall under any of the following or gravity gradiometers

イ 地上用に設計した重力計であって、静止状態において重力を測定する場合の精度が一〇マイクロガル未満のもの（ウォルドン型のを除く。）

(a) Gravity meters designed for ground use with a precision of less than 10 microgals when gravity is measured in a stationary state (excluding Woldon types)

ロ 移動体搭載用に設計した重力計であって、次の（一）及び（二）に該当するもの

(b) Gravity meters designed for mounting on movable bodies that fall under the following 1. and 2.

（一） 静止状態において重力を測定する場合の精度が〇・セミリガル未満のもの

1. Gravity meters the precision of which when gravity is measured in a stationary state is less than 0.7 milligals

（二） 変動状態において重力を測定する場合の精度が〇・セミリガル未満で、かつ、測定所要時間が二分未満のもの

2. Gravity meters the precision of which when gravity is measured in a fluctuating state is less than 0.7 milligals and for which required measuring time is less than 2 minutes

十三 レーダーであって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品（二次監視レーダー、衝突防止用に設計した自動車レーダー、解像度が一ミリメートル当たり一二本以下の航空管制用の表示装置、気象レーダー及びこれらの部分品を除く。）

(xiii) Radars that fall under any of the following or components thereof (excluding secondary supervisory radar, automobile radar designed to prevent collisions, display equipment for aircraft control use with resolution of 12 or less per millimeter and meteorological radar and components thereof)

イ 四〇ギガヘルツ以上二三〇ギガヘルツ以下の周波数範囲で使用することができるレーダーであって、平均出力が一〇〇ミリワットを超えるもの

(a) Radars that can be used within a frequency range of 40 gigahertz or more and 230 gigahertz or less and with an average output exceeding 100

milliwatts

- ロ 同調可能な帯域の幅が中心周波数の一二・五パーセントを超えるもの
- (b) Radars having a bandwidth capable of being tuned that exceeds the center frequency by 12.5 %
- ハ 三以上の搬送周波数を同時に使用することができるもの
- (c) Radars which are capable of using three or more carrier frequencies simultaneously
- ニ 合成開口レーダー、逆合成開口レーダー又は側方監視レーダーとして使用することができるもの
- (d) Radars which are capable of being used as synthetic aperture radar, reverse synthetic radar or supervisory radar
- ホ 電子的に走査が可能なフェーズドアレイアンテナを組み込んだもの
- (e) Radars with built-in phased array antennas which are capable of electronic scanning
- ヘ 目標の高度を測定することができるもの（国際民間航空機関の標準に準拠した精測進入レーダーを除く。）
- (f) Radars which are capable of measuring a target altitude (excluding Precision Approach Radar based on international civil aviation organization standards)
- ト 気球又は航空機に搭載するように設計したものであって、移動する目標を検出するためにドップラー効果を利用するもの
- (g) Radars which are designed to be mounted on balloons or aircraft and which utilize the Doppler effect to detect a moving target
- チ 次のいずれかの技術を利用するもの
- (h) Radars which utilize any of the following technologies
- (一) スペクトル拡散
1. Spectrum spread
- (二) 周波数アジリティー
2. Frequency agility
- リ 地上用のものであって、計測距離が一八五キロメートルを超えるもの（漁場監視レーダー、航空管制用に設計した地上レーダー及び気象用気球追尾レーダーを除く。）
- (i) Radars for ground use, the measured distance of which exceeds 185 km (excluding fishing ground supervisory radar and ground radar and meteorological balloon tracking radar designed for air control use.)
- ヌ レーザーレーダー（ライダーを含む。）であって、次のいずれかに該当するもの（測量用又は気象観測用のライダーを除く。）
- (j) Laser radar (including lidar) which falls under any of the following (excluding lidars for surveying and meteorological observation use.)
- (一) 宇宙用に設計したもの
1. Laser radar designed for space use

(二) ヘテロダイン検波又はホモダイン検波の技術を利用し、かつ、角度分解能が二〇マイクロラジアン未満のもの

2. Laser radar which utilize heterodyne phase detection or homodyne phase detection technology and the angular resolution of which is less than 20 microradians

ル 次のいずれかに該当するパルス圧縮技術を利用するもの

(k) Radars which utilize pulse compression technology which fall under any of the following

(一) パルス圧縮比が一五〇を超えるもの

1. Radars with a pulse compression ratio exceeding 150

(二) パルス幅が二〇〇ナノ秒未満のもの

2. Radars with a pulse width less than 200 nanoseconds

ヲ 次のいずれかに該当するデータ処理技術を利用するもの

(l) Radars which utilize data processing technology which fall under any of the following

(一) 自動目標追尾の技術であって、次回のアナテナビームが通過する時点より先の時点における目標の未来位置を予測することができるもの（衝突防止用のものであって、航空管制用、船舶搭載用又は港湾用のものを除く。）

1. Automatic target tracking technology which is capable of estimating the future position of a target starting from the point where the next antenna beam passes (excluding those used to prevent collisions, used for air control, for installation on vessels or for harbor use.)

(二) 走査速度が一定でない一次レーダーを用いて目標の速度を計算する技術

2. Technology which is used to calculate the target speed using the following types of radar the scanning speed of which is not constant.

(三) 互いの距離が一、五〇〇メートルを超え、かつ、実時間でデータを交換する二以上のレーダーを用い、目標の強調又は識別をするために目標データの重ね合わせ、相関又はデータフュージョンを行う技術（海上交通管制用のものを除く。）

3. Technology which uses radar with mutual distance exceeding 1,500 meters, which uses two or more types of radar to switch data in real time and which superposes target data to emphasize or identify a target (excluding those used for sea traffic control.)

(四) 車両、船舶、航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体に搭載したレーダーを含む二以上のレーダー（実時間でデータを交換するものに限る。）を用い、目標の強調又は識別をするために目標データの重ね合わせ、相関又はデータフュージョンを行う技術（海上交通管制用のものを除く。）

4. Technology which uses two or more types of radar which include radar installed on airframes for vehicles, vessels, aircraft or satellites or other types of spacecraft for space development (limited to those which switch data in real time), and combines object data and performs

correlation or data fusion to emphasize or distinguish the objective  
(excluding that used in marine traffic administration)

十四 光学の測定装置であって、次のいずれかに該当するもの

(xiv) Optical measuring equipment that falls under any of the following

イ 光の反射率の測定装置（反射率の絶対値を測定するものに限る。）であって、その精度の絶対値が〇・一パーセント以下のもの

(a) Equipment for measuring optical reflectance (limited to those which measure the absolute value of reflectance) the precision absolute value of which is 0.1 % or less

ロ レンズ又は反射鏡の表面の形状の測定装置（非接触型のものに限る。）であって、光散乱の計測以外の方法を用いるもののうち、開口の直径が一〇センチメートルを超え、かつ、平面でない面形状を二ナノメートル以下の精度で測定するように設計したもの

(b) Among equipment (limited to non-contact type) for measuring the surface shape of lenses or reflectors, which uses a method other than measurement of light scattering, that having an aperture diameter exceeding 10 centimeters and designed for measuring surface shapes which are not planar at a precision of 2 nanometers or less

十五 地上用の重力計（静止状態において重力を測定する場合の精度が〇・一ミリガル未満のものに限る。）の製造用の装置又は校正装置

(xv) Equipment for the manufacture or calibration equipment of gravity meters for ground use (limited to those the precision of which, when gravity is measured in a stationary state, is less than 0.1 milligals)

十六 光検出器その他の光学部品の材料となる物質又はレーザー発振器用の結晶であって、次のいずれかに該当するもの

(xvi) Crystals for optical detectors and other material or laser oscillators made of a material for optical components that falls under any of the following:

イ テルルであって、純度が九九・九九九五パーセント以上のもの

(a) Tellurium with a purity of 99.9995 % or more

ロ 次のいずれかに該当するものの単結晶又はエピタキシャル成長結晶を有するウエハー

(b) Wafers having a single crystal or epitaxial growth crystal which fall under any of the following

(一) テルル化亜鉛のテルル化カドミウム及びテルル化亜鉛に対するモル比が六パーセント未満のテルル化亜鉛カドミウム

1. Cadmium zinc telluride the mole ratio for zinc telluride relative to cadmium telluride and zinc telluride for which is less than 6 %

(二) テルル化カドミウム

2. Cadmium telluride

(三) テルル化水銀カドミウム

3. Cadmium mercury telluride

ハ セレン化亜鉛又は硫化亜鉛からなる基板材料であって、化学的気相成長法により製造したもののうち、次のいずれかに該当するもの

(c) Among substrate materials made up of zinc selenide or zinc sulfide manufactured by the chemical vapor phase growth methods, those which fall under any of the following

(一) 体積が一〇〇立方センチメートルを超えるもの

1. Substrate materials, the volume of which exceeds 100 cubic centimeters

(二) 直径が八〇ミリメートルを超え、かつ、厚さが二〇ミリメートル以上のもの

2. Substrate materials, the diameter of which exceeds 80 millimeters and the thickness of which is 20 millimeters or more

ニ 固体の電気光学材料であって、次のいずれかに該当するもの

(d) Solid state electro-chemical materials which fall under any of the following.

(一) 砒素酸チタニルカリウム

1. Potassium titanyl arsenate

(二) セレン化ガリウム銀

2. Silver gallium selenide

(三) セレン化タリウム砒素

3. Arsenic thallium selenide

ホ 非線形光学材料であって、次の (一) 及び (二) に該当するもの

(e) Non-linear optical materials which fall under the following 1. and 2.

(一) 三次の感受率が一〇〇万分の一平方メートル毎ボルト毎ボルト以上のもの

1. Non-linear optical materials the cubic susceptibility of which is greater than 1/1,000,000 per square meter per volt per volt

(二) 応答時間が一ミリ秒未満のもの

2. Non-linear optical materials the response time of which is less than 1 millisecond

ヘ ベリリウム上にベリリウムを堆積した材料又は炭化けい素からなる基板材料であって、直径又は長軸の長さが三〇〇ミリメートルを超えるもの

(f) Substrate materials made up of materials having beryllium stacked on beryllium or substrate material made up of silicon carbide having a diameter or major axis length which exceeds 300 millimeters.

ト 光学ガラスであって、次の (一) から (三) までのすべてに該当するもの

(g) Optical glass which falls under all of the following 1. through 3.

(一) 水酸化物イオンの含有量が全重量の〇・〇〇〇五パーセント未満のもの

1. Optical glass the hydroxide ion content of which is less than 0.0005 % of the total weight

(二) 金属不純物の含有量が全重量の〇・〇〇〇一パーセント未満のもの

2. Optical glass the metal impurities content of which is less than 0.0001 %

of the total weight

(三) 屈折率の変動が一〇〇万分の五未満のもの

3. Optical glass the refractive index variation of which is less than 5/1,000,000

チ 人工ダイヤモンドであって、二〇〇ナノメートル超一四、〇〇〇ナノメートル以下の波長範囲における吸収係数が一センチメートル当たり一〇万分の一未満のもの

(h) Artificial diamonds the absorption coefficient of which is less than 1/100,000 per centimeter within a wavelength range exceeding 200 nanometers and 14,000 nanometers or less

リ レーザー発振器用の人工の結晶であって、未完成のもののうち、次のいずれかに該当するもの

(i) Among artificial crystals for laser oscillators that are unfinished, those that fall under any of the following

(一) チタンを添加したサファイア

1. Sapphires with titanium added

(二) アレキサンドライト

2. Alexandrite

第十条 輸出令別表第一の一の項の経済産業省令で定める仕様のもものは、次のいずれかに該当するものとする。

Article 10 Goods with specifications prescribed by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 11 of the appended table 1 of the Export Order shall fall under any of the following.

一 直線加速度計であって、慣性航法装置用又は慣性誘導装置用のもののうち、次のいずれかに該当するもの又はその部分品

(i) Among linear accelerometers used for inertial navigation systems or inertial guidance systems, those that fall under any of the following or components thereof

イ バイアスの安定性（校正後のものをいう。以下この条において同じ。）が一年間につき〇・〇〇一二八メートル毎秒毎秒未満のもの

(a) Linear accelerometers with a bias stability (following calibration; hereinafter the same shall apply in this Article) of less than 0.00128 meters per second squared per year

ロ スケールファクターの安定性が一年間につき〇・〇一三パーセント未満のもの

(b) Linear accelerometers with a scale factor stability of less than 0.013 % per year

ハ 九八一メートル毎秒毎秒を超える直線加速度で使用することができるように設計したもの

(c) Linear accelerometers designed so that they are capable of being used at a linear acceleration exceeding 981 meters per second squared

二 ジャイロスコープ、角加速度計又は回転加速度計であって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品

(ii) Gyroscopes, angular accelerometers or rotary accelerometers which fall under any of the following or components thereof

イ 九・八一メートル毎秒毎秒の直線加速度の状態におけるドリフトレートの安定性が一月間で次のいずれかに該当するもの

(a) Gyroscopes, angular accelerometers or rotary accelerometers in which drift rate stability in a linear acceleration state per 9.81 meters per second squared per month, and falls under any of the following

(一) 一一七・七メートル毎秒毎秒未満の直線加速度で使用することができるように設計したものにあっては、一時間につき〇・一度未満のもの

1. Gyroscopes, angular accelerometers or rotary accelerometers which are designed for use at a linear acceleration of less than 117.7 meters per second squared in which linear acceleration is less than 0.1 degrees per hour

(二) 一一七・七メートル毎秒毎秒以上九八一メートル毎秒毎秒以下の直線加速度で使用することができるように設計したものにあっては、一時間につき〇・五度未満のもの

2. Gyroscopes, angular accelerometers or rotary accelerometers which are designed for use at a linear acceleration of 117.7 meters per second squared or more and 981 meters per second squared or less in which a linear acceleration is less than 0.5 degrees per hour

ロ 角度のランダムウォークを時間の平方根当たりで表した実効値が〇・〇〇三五度以下のもの（スピニングマスジャイロを除く。）

(b) Gyroscopes, angular accelerometers or rotary accelerometers the effective value of which indicates the angular random walk in degrees per square root of hours of 0.0035 degrees or less (excluding spinning mass gyro)

ハ 九八一メートル毎秒毎秒を超える直線加速度で使用することができるように設計したもの

(c) Gyroscopes, angular accelerometers or rotary accelerometer designed so that they are capable of being used at a linear acceleration which exceeds 981 meters per second squared

三 航空機用、陸上用、船舶用若しくは宇宙用の慣性航法装置（ジンバル方式又はストラップダウン方式のものに限る。）若しくは姿勢検知、誘導若しくは制御用の慣性装置であって、次のいずれかに該当するもの（本邦又は別表第二に掲げる地域のいずれかの政府機関により、民間航空機用であることを認定されたものを除く。）又はこれらの部分品

(iii) Inertial navigation systems used for aircraft, ground use vessels or space use (limited to gimbal systems or strap down systems) or inertial systems used for attitude sensing, guidance or control which fall under any of the following (excluding those authorized for civil aviation use by Japan or by

any of the government organizations indicated in the regions listed in the appended table 2) or components thereof

イ ノーマルアライメント後における平均誤差半径が一時間につき〇・八海里以下のもの

(a) Those in which mean error radius after normal alignment is 0.8 nautical miles per hour or less

ロ 九八・一メートル毎秒毎秒を超える直線加速度で使用することができるように設計したもの

(b) Inertial navigation systems which are designed for use at linear accelerations which exceed 98.1 meters per second squared

三の二 姿勢検知、誘導若しくは制御のための全地球的衛星航法装置若しくはデータベース参照航法装置（以下この条において「特定航法装置」という。）を内蔵しているハイブリッド慣性航法装置であって、ノーマルアライメント後における特定航法装置からのデータの喪失後の平均誤差半径が四分間につき一〇メートル未満のもの又はその部分品

(iii)-2 Hybrid inertial navigation systems with internally stored global satellite navigation systems used for attitude sensing, guidance or control or data reference navigation systems (hereinafter in this Article "specific navigation systems") in which mean error radius after loss of data from a specific navigation system after normal alignment is less than 10 meters per four-minute period or components thereof

三の三 進行方向、機首（船首）方向若しくは真北方向を示す慣性装置であって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品

(iii)-3 Inertial systems indicating the traveling direction, the nose (bow) direction, or the true north direction which fall under any of the following or components thereof

イ 緯度四五度の地点において、進行方向、機首（船首）方向若しくは真北方向を示す誤差の実行値が六分以下のもの（慣性装置を含むセオドライトであって、民生用途のために設計したものを除く。）

(a) Inertial systems in which executed error value indicating the traveling direction, nose (bow) direction or true north direction at 45 degrees latitude is six minutes or less (excluding theodolites comprising an inertial system and those designed for civil use.)

ロ 非動作状態において一ミリ秒以上の期間、八、八二九メートル毎秒毎秒以上の衝撃加速度に耐えることができるもの

(b) Inertial systems which are capable of withstanding shock acceleration for a period of more than 1 millisecond in a non-operating state at more than 8,829 meters per second squared

四 ジャイロ天測航法装置又は天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置であって、方位精度が五秒以下のもの

(iv) Gyroscopes for celestial navigation or devices that derive position or



- orientation by means of automatically tracking celestial bodies or satellites and which have a bearing accuracy of 5 seconds or less
- 五 衛星航法システムからの電波を受信する装置であって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品
- (v) Devices which receive radio waves from global navigation satellite systems that fall under any of the following, or components thereof
- イ 暗号の復号機能を有するもの
- (a) Those having a cipher decoding function
- ロ ナルステアラブルアンテナを有するもの
- (b) Those having a null steerable antenna
- 六 航空機用の高度計であって、四・四ギガヘルツを超える周波数又は四・二ギガヘルツより低い周波数で使用するできるように設計したもののうち、次のいずれかに該当するもの
- (vi) Among aircraft altimeters which are designed for use at frequencies greater than 4.4 gigahertz or at frequencies lower than 4.2 gigahertz, those which fall under any of the following
- イ 送信出力制御機能を有するもの
- (a) Aircraft altimeters having a transmission output control function
- ロ 位相偏移変調機能を有するもの
- (b) Aircraft altimeters having a phase deviation modulation function
- 七 削除
- (vii) Deleted
- 八 第一号から第六号までのいずれかに該当するものの試験装置、校正装置、心合わせ装置又は製造用の装置
- (viii) Test equipment, calibration equipment, alignment equipment or equipment for manufacture that fall under any of item (i) through item (vi)
- 九 リングレーザージャイロの鏡面の特性確認のために設計した装置であって、次のいずれかに該当するもの
- (ix) Devices which are designed to confirm the characteristics of the mirror surface of a ring laser gyro that fall under any of the following
- イ スキャッタロメータであって、測定精度が〇・〇〇一パーセント以下のもの
- (a) Scatterometers having a measuring precision of 0.001 % or less
- ロ プロフィロメータであって、測定精度が〇・五ナノメートル以下のもの
- (b) Profilometers having a measuring precision of 0.5 nanometers or less

第十一条 輸出令別表第一の一の二の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

Article 11 Goods with specifications prescribed by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 12 of the appended table 1 of the Export Order shall fall under any of the following.

- 一 繫索式の潜水艇であって、一、〇〇〇メートルを超える水深で使用することがで

- きるように設計したもののうち、次のいずれかに該当するもの
- (i) Among small mooring-rope type submersible boats which are designed so that they are capable of being used at depths exceeding 1,000 meters, those which fall under any of the following
- イ 有人式の潜水艇
- (a) Manned submersible vessels
- ロ 無人式の潜水艇であって、次のいずれかに該当するもの
- (b) Unmanned submersible vessels which fall under any of the following
- (一) 直流の推進電動機又はスラスタを使用して、独力で潜航することができるように設計したもの
1. Small unmanned submersible vessels which use direct current propulsion electric motors and which are designed so that they are capable of being used for navigation unaided
- (二) 光ファイバーによってデータを送受することができるもの
2. Small unmanned submersible boats capable of transmitting and receiving data using optical fiber
- 二 二五〇メートルを超える水深にある物体を回収するための装置であって、五メガニュートンを超える揚荷能力を有し、かつ、次のいずれかに該当するもの
- (ii) Equipment which is used to recover objects at depths exceeding 250 meters having a cargo unloading capability exceeding 5 mega newtons and which fall under any of the following
- イ 航法装置によって設定した点から二〇メートル以内の範囲に位置を保持することができる自動船位保持装置を有するもの
- (a) Equipment having an automatic ship position maintaining device which is capable of maintaining the position of the ship within a range of 20 meters from a point set by the navigation device
- ロ 一、〇〇〇メートルを超える水深において、あらかじめ定められた点から一〇メートルの範囲に位置を保持することができるもの
- (b) Equipment which is capable of maintaining a position within a range of 10 meters from a preset point at depths exceeding 1,000 meters
- 三 水上船であって、次のいずれかに該当するもの
- (iii) Surface ships which fall under any of the following
- イ エアクッション船であって、次のいずれかに該当するもの
- (a) Air-cushion vehicles which fall under any the following
- (一) スカート型のもの（船体の全周にフレキシブルスカートを取り付けたものに限る。）であって、有義波高が一・二五メートル以上の場合における満載状態の速力の最大値が三〇ノットを超えるように設計したもののうち、クッションの圧力が三、八三〇パスカルを超え、かつ、満載排水量に対する軽荷排水量の比率が七〇パーセント未満のもの
1. Among side wall type vehicles (limited to those with attached flexible skirts on the periphery of the ship's hull) designed so that the

maximum value of the speed when full, and when the significant wave height is 1.25 meters or more, and the speed of which exceeds 30 knots, those for which the cushioning pressure exceeds 3,830 pascals and the ratio of light load displacement relative to full load displacement is less than 70 %

(二) 側壁型のものであって、有義波高が三・二五メートル以上の場合における満載状態の速力の最大値が四〇ノットを超えるように設計したもの

2. Side wall type vehicles which are designed so that the maximum value of the speed when full when the significant wave height is 3.25 meters or more, exceeds 40 knots

ロ 水中翼船であって、有義波高が三・二五メートル以上の場合における満載状態の速力の最大値が四〇ノット以上になるように設計したもののうち、船体の揺れ、波の状態その他のデータを測定することによって水中翼を自動的に制御する装置を有するもの

(b) Among hydrofoil ships which are designed so that the maximum value of the speed when full when significant wave height is 3.25 meters or more exceeds 40 knots, those which have a device to automatically control the hydrofoil by measuring the condition of the waves and other data

ハ 線面積を小さくすることによって造波抵抗を減少させるように設計した船舶であって、次のいずれかに該当するもの

(c) Vessels which are designed so that they are capable of reducing wave creation resistance by reducing the area of the water line which falls under any of the following.

(一) 満載排水量が五〇〇トンを超えるものであって、有義波高が三・二五メートル以上の場合における満載状態の速力の最大値が三五ノットを超えるように設計したもの

1. Vessels in which full load displacement exceeds 500 tons and which are designed so that the maximum value of the speed when full when the significant wave height is 3.25 meters or more exceeds 35 knots

(二) 満載排水量が一、五〇〇トンを超えるものであって、有義波高が四メートル以上の場合における満載状態の速力の最大値が二五ノットを超えるように設計したもの

2. Vessels for which full load displacement exceeds 1,500 tons and which are designed so that the maximum value of speed when full when the significant wave height is 4 meters or more exceeds 25 knots

四 潜水艇の部分品又は附属装置であって、次のいずれかに該当するもの

(iv) Components or auxiliaries for submersible vessels which fall under any of the following

イ 一、〇〇〇メートルを超える水深で使用することができるように設計した潜水艇の部分品であって、次のいずれかに該当するもの

(a) Components for submersible vessels which are designed so that they are

capable of being used at depths exceeding 1,000 meters which fall under any of the following

(一) 最大の内のり寸法が一・五メートルを超える耐圧容器又は耐圧殻

1. Pressure-resistant containers or pressure-resistant shells in which maximum internal dimensions exceed 1.5 meters

(二) 直流の推進電動機又はスラスタ

2. Direct current propulsion electric motors or thrusters

(三) 光ファイバー及び合成材のテンションメンバを使用したアンビリカルケーブル又はそのコネクタ (三) 光ファイバー及び合成材のテンションメンバを使用したアンビリカルケーブル又はそのコネクタ

3. Umbilical cables or connectors which use tension members made of optical fiber and synthetic materials

ロ 潜水艇に使用することができるように設計した自動制御装置であつて、航法データを使用し、かつ、サーボ制御方式であるもののうち、次の(一)及び(二)に該当するもの

(b) Among automatic control devices which are designed so that they are capable of being used in submersible vessels which use navigation data and which are servo control systems, those that fall under the following 1. and 2.

(一) 第一号ロ又は第十四条第九号に該当する潜水艇に使用することができるもの

1. Automatic control devices which are capable of being used for submersible vessels which fall under item (i), (b) or Article 14, item (ix)

(二) 次のいずれかに該当するもの

2. Automatic control devices which fall under any of the following

1 水中のあらかじめ定められた点を中心とする半径一〇メートルの水柱内に潜水艇を移動することができるもの

i. Automatic control devices which are capable of moving submersible vessels inside a water column having a radius of 10 meters having a preset center point in the water

2 水中のあらかじめ定められた点を中心とする半径一〇メートルの水柱内に潜水艇を保持することができるもの

ii. Automatic control devices which are capable of holding a submersible vessel inside a water column having a radius of 10 meters having a preset center point in the water

3 海底又は海底下にあるケーブルに沿って移動する際に、ケーブルから一〇メートル以内に潜水艇を保持することができるもの

iii. Automatic control devices which are capable of holding a small submersible vessel to within 10 meters of a cable when moving along a cable which is at the bottom of the sea or beneath the sea

ハ 潜水艇に使用することができるように設計した自動制御装置であつて、航法デ

ータを使用し、かつ、サーボ制御方式であるもののうち、次の（一）及び（二）に該当するもの（ロに該当するものを除く。）

(c) Among automatic control devices which are designed so that they are capable of being used in submersible vessels, which use navigation data and which are servo control systems, those that fall under 1. and 2. (excluding those falling under (b))

(一) 第一号イに該当する潜水艇に使用することができるように設計したもの

1. Automatic control devices which are designed so that they are capable of being used in submersible vessels and which fall under item (i), (a)

(二) 次のいずれかに該当するもの

2. Automatic control devices that fall under any of the following

1 水中のあらかじめ定められた点を中心とする半径一〇メートルの水柱内に潜水艇を移動することができるもの

i. Automatic control devices which are capable of moving submersible vessels inside a water column having a radius of 10 meters having a preset center point in the water

2 水中のあらかじめ定められた点を中心とする半径一〇メートルの水柱内に潜水艇を保持することができるもの

ii. Automatic control devices which are capable of holding submersible vessels within a water column having a radius of 10 meters having a present center point in the water

3 海底又は海底下にあるケーブルに沿って移動する際に、ケーブルから一〇メートル以内に潜水艇を保持することができるもの

iii. Automatic control devices which are capable of holding submersible vessels inside a water column within 10 meters from the cable when moving along a cable which is on the sea floor or beneath the sea

ニ 光ファイバーを船体内に引き込むための貫通金物又は光ファイバー用のコネクタ

(d) Lead-through hardware or optical fiber connectors used to draw optical fiber inside the hull of a ship

ホ 水中用の観測装置であって、次のいずれかに該当するもの

(e) Observation devices for underwater use that fall under any of the following

(一) 潜水艇に搭載して遠隔操作することができるように設計した水中テレビジョン装置であって、空気中における解像度が八〇〇本を超えるもの

1. Underwater television devices which are designed so that they are capable of being mounted onto submersible vessels for remote control and with a resolution in air exceeding 800

(二) 潜水艇に搭載して遠隔操作することができるように設計したものであって、後方散乱による影響を減少させる機能を有するもの

2. Observation devices for underwater use which are designed so that they

are capable of being used in submersible vessels for remote control and having a function which reduces the effect of backscattering

五 水中用のカメラ又はその附属装置であって、次のいずれかに該当するもの

(v) Underwater cameras or auxiliaries thereof which fall under any of the following

イ テレビカメラであって、次のいずれかに該当するもの

(a) Television cameras that fall under any of the following

(一) 空気中における解像度が一、一〇〇本を超えるもの

1. Television cameras with a resolution in air exceeding 1,100

(二) 第九条第三号ロ(一)に掲げるイメージ増強管を組み込み、かつ、固体撮像素子の有効画素数が一五〇、〇〇〇を超えるもの

2. Television cameras with a built-in image reinforcing tube listed in Article 9, item (iii), (b), 1. having more than 150,000 effective pixels for its solid-state image sensors

ロ 一五〇メートルを超える水深で使用できるように設計又は改造された写真機(幅が三五ミリメートル以上のフィルムを用いるものに限る。)であって、次のいずれかに該当するもの

(b) Cameras which are designed or manufactured so that they are capable of being used at depths exceeding 150 meters (limited to those using film with a width of 35 millimeters or more) which fall under any of the following

(一) 水深、位置その他の測定データをフィルムに記録することができるもの

1. Cameras which are capable of recording the depth, position and other measurement data on film

(二) バックフォーカルディスタンスを自動的に補正する機能を有するもの

2. Cameras having a function which automatically compensates for the back focal distance

(三)ハウジングが一、〇〇〇メートルを超える水深で使用することができるように設計した自動的な制御装置を有するもの

3. Cameras having an automatic control device which is designed so that its housing is capable of being used at depths exceeding 1,000 meters

ハ 電子式に画像を記録することができるカメラであって、五〇を超える画像を記録することができるもの

(c) Cameras which are capable of recording images electronically and which are capable of recording more than 50 images

ニ 照明装置であって、次のいずれかに該当するもの

(d) Lighting systems which fall under any of the following

(一) ストロボ法を用いたものであって、一回のフラッシュ当たりのエネルギーが三〇〇ジュールを超えるもののうち、一秒間に五回を超えて発光することができるもの

1. Among lighting systems which use the strobo method, in which energy per flash exceeds 300 joules, those that are capable of emitting light in

excess of five times per second

(二) アルゴンのアークを用いたものであって、一、〇〇〇メートルを超える水深で使用することができるように設計したもの

2. Lighting systems which use argon arcs which are designed so that they are capable of being used at depths exceeding 1,000 meters

六 水中用のロボット（操縦ロボット及びシーケンスロボットを除く。）であって、次のいずれかに該当するもの

(vi) Underwater robots (excluding maneuvering robots and sequence robots) which fall under any of the following

イ 外部物体に加えた力若しくはトルク、外部物体までの距離又は触覚を測定するセンサーからの情報を用いて制御するもの

(a) Underwater robots which control use of information from a sensor which measures the force or torque applied to an external object or the distance to tactual sense with the external object

ロ 構造材にチタン合金又は繊維強化複合材料を用いたものであって、二五〇ニュートン以上の力又は二五〇ニュートンメートル以上のトルクで作業することができるもの

(b) Underwater robots which use titanium alloy or fiber reinforced composite materials as structural materials and which are capable of being operated under a force of more than 250 newtons or at a torque greater than 250 newtons

七 潜水艇に搭載することができるように設計した遠隔操作のマニピュレーター（関節を有するものに限る。）であって、次のいずれかに該当するもの

(vii) Remote control manipulators (limited to those which are articulated) which are designed so that they are capable of being mounted on submersible vessels which fall under any of the following

イ 外部物体に加えた力若しくはトルク又は外部物体との触覚を測定するセンサーからの情報を用いて制御するもの

(a) Remote control manipulators which use information from a sensor which measures the force applied to an external object or the torque or the tactual sense upon the external object.

ロ マスタースレーブ方式によって制御するものものであって、動作自由度が五以上のもの

(b) Remote control manipulators which control the use of a master-slave system with a degree of freedom of motion of 5 or more

八 大気から遮断された状態で使用することができる動力装置であって、次のいずれかに該当するもの

(viii) Power units which are capable of being used when they are cut off from the air that fall under any of the following

イ ブレイトンサイクルエンジン又はランキンサイクルエンジンであって、次のいずれかに該当する装置を有するもの

(a) Brayton cycle engines or Rankine cycle engines having a device that falls under any of the following

(一) 循環する排気から一酸化炭素、二酸化炭素及び微粒子を除去することができるように設計した装置

1. Equipment which is designed so that it is capable of removing carbon monoxide, carbon dioxide as well as particles from the exhaust air which is circulating

(二) 単原子で構成される気体を利用することができるように設計した装置

2. Equipment designed so that it is capable of utilizing monoatomic gases

(三) 一〇キロヘルツ未満の周波数の水中ノイズを減少させることができるように設計した防音装置若しくはエンクロージャ又は衝撃を緩和することができるように設計した装置

3. Soundproofing devices or enclosures designed so that they are capable of reducing underwater noise at frequencies of less than 10 kilohertz or equipment which is designed so that it is capable of mitigating collisions

(四) 反応生成物を圧縮又は燃料として再生することができ、反応生成物を貯蔵することができ、かつ、一〇〇キロパスカル以上の圧力下で反応生成物を排出することができるように設計した装置

4. Equipment designed so that it is capable of compressing reaction products or recycling them as fuel, storing the reaction products and discharging the reaction products at pressures of more than 100 kilopascals.

ロ ディーゼルエンジンであって、次の (一) から (四) までのすべてに該当する装置を有するもの

(b) Diesel engines having equipment that falls under all of the following 1. through 4.

(一) 循環する排気から一酸化炭素、二酸化炭素及び微粒子を除去することができるように設計した装置

1. Equipment designed so that it is capable of removing carbon monoxide, carbon dioxide and fine particles from exhaust air which is circulating

(二) 単原子で構成される気体を利用することができるように設計した装置

2. Equipment which is designed so that it is capable of utilizing monoatomic gases

(三) 一〇キロヘルツ未満の周波数の水中ノイズを減少させることができるように設計した防音装置若しくはエンクロージャ又は衝撃を緩和することができるように設計した装置

3. Soundproofing devices or enclosures which are designed so that they are capable of reducing underwater noise at frequencies of less than 10 kilohertz or equipment which is designed so that it is capable of mitigating collisions



(四) 燃焼生成物を断続的に排出することができるように設計した装置

4. Equipment which is designed so that it is capable of discharging combustion products intermittently

ハ 出力が二キロワットを超える燃料電池であって、次のいずれかに該当する装置を有するもの

(c) Fuel cells with an output exceeding 2 kilowatts and having a device that falls under any of the following

(一) 一〇キロヘルツ未満の周波数の水中ノイズを減少させることができるように設計した防音装置若しくはエンクロージャ又は衝撃を緩和することができるように設計した装置

1. Soundproofing devices or enclosures which are designed so that they are capable of reducing underwater noise at frequencies of less than 10 kilohertz or equipment designed so that it is capable of mitigating collisions

(二) 反応生成物を圧縮又は燃料として再生することができ、反応生成物を貯蔵することができ、かつ、一〇〇キロパスカル以上の圧力下で反応生成物を排出することができるように設計した装置

2. Equipment which is designed so that it is capable of compressing reaction products or recycling them as fuel, which are capable of storing the reaction products and discharging reaction products at pressures greater than 100 kilopascals

ニ スターリングサイクルエンジンであって、次の(一)及び(二)に該当する装置を有するもの

(d) Sterling cycle engines having equipment which falls under any of the following 1. and 2.

(一) 一〇キロヘルツ未満の周波数の水中ノイズを減少させることができるように設計した防音装置若しくはエンクロージャ又は衝撃を緩和することができるように設計した装置

1. Soundproofing devices or enclosures which are designed so that they are capable of reducing underwater noise at frequencies of less than 10 kilohertz or equipment which is designed so that it is capable of mitigating collisions

(二) 一〇〇キロパスカル以上の圧力下で反応生成物を排出することができるように設計した装置

2. Equipment which is designed so that it is capable of discharging reaction products at pressures greater than 100 kilopascals

九 第三号に該当する水上船の部分品であって、次のいずれかに該当するもの

(ix) Components for surface ships which fall under item (iii), and which fall under any of the following

イ フレキシブルスカート、シール又はフィンガーであって、次のいずれかに該当するもの

- (a) Flexible skirts, seals or fingers which fall under any of the following
- (一) 第三号イ (一) に該当するエアクッション船に使用することができるように設計したものであって、クッションの圧力が三、八三〇パスカル以上であるもののうち、有義波高が一・二五メートル以上の場合において使用することができるように設計したもの
1. Among flexible skirts, seals or fingers which are designed so that they are capable of being used in air-cushion vehicles which fall under item (iii), (a), 1. in which cushioning pressure is 3,830 pascals or more, those which are capable of being used when the significant wave height is 1.25 meters or more
- (二) 第三号イ (二) に該当するエアクッション船に使用することができるように設計したものであって、クッションの圧力が六、二二四パスカル以上であるもののうち、有義波高が三・二五メートル以上の場合において使用することができるように設計したもの
2. Among flexible skirts, seals or fingers which are designed so that they are capable of being used in air-cushion vehicles which fall under item (iii), (a), 2. and in which cushioning pressure is greater than 6,224 pascals, those which are designed so that they are capable of being used when the significant wave height is 3.25 meters or more
- ロ 第三号イに該当するエアクッション船に使用することができるように設計した浮上用ファンであって、定格入力が四〇〇キロワットを超えるもの
- (b) Levitation fans which are designed so that they are capable of being used on air-cushion vehicles which fall under item (iii), (a) in which rated output exceeds 400 kilowatts
- ハ 第三号ロに該当する水中翼船に使用することができるように設計した完全没水型の水中翼であって、キャビテーション損傷を減少させるように設計されたもの
- (c) Totally submersible hydrofoils which are designed so that they are capable of being used in hydrofoil ships which fall under item (iii), (b) which are designed to reduce capitation damage
- ニ 船体の揺れ、波の状態その他の測定データを利用する自動安定性制御装置
- (d) Automatic stabilizing control devices which utilize the shaking of the ship's hull, wave conditions and other measurement data
- ホ スーパーキャビテーションプロペラ、半没水型プロペラ又はサーフェスプロペラであって、定格入力が七・五メガワットを超えるもの
- (e) Super capitation propellers, semi-submersible propellers or surface propellers, the rated output of which exceeds 7.5 megawatts
- ヘ 二重反転プロペラ装置であって、定格入力が一五メガワットを超えるもの
- (f) Double reversing propeller devices, the rated output of which exceeds 15 megawatts
- ト プロペラへ向かう水流を整流する機能を有する装置
- (g) Equipment having a function which rectifies the stream which faces the

propeller

チ 減速装置であって、アメリカ歯車工業会の規格で定めるK値が三〇〇を超えるもの

(h) Decelerators the K value of which is indicated in the standards of the American Gear Industry Association and exceeds 300

リ 複合材料を用いた伝動軸装置であって、一メガワットを超える出力を伝達することができるもの

(i) Transmission shaft equipment which uses composite materials which are capable of transmitting output greater than 1 megawatt

十 船舶の部分品であって、次のいずれかに該当するもの

(x) Vessel components which fall under any of the following

イ 可変ピッチプロペラ又はそのハブであって、定格入力が一・三〇メガワットを超えるもの

(a) Variable pitch propellers or hubs thereof with a rated output exceeding 30 megawatts

ロ 内部液冷式の電気推進機関であって、出力が二・五メガワットを超えるもの

(b) Internal liquid-cooling type electric propulsion engines in which output exceeds 2.5 megawatts

ハ 超電導式推進機関又は永久磁石を用いた電気推進機関であって、出力が一・〇メガワットを超えるもの

(c) Superconductive propulsion engines or electric propulsion engines using a permanent magnet having an output greater than 0.1 megawatts

ニ 複合材料を用いた伝動軸装置であって、二メガワットを超える出力を伝達することができるもの

(d) Power transmission shaft equipment using a composite material which is capable of transmitting output exceeding 2 megawatts

ホ スクリュープロペラ装置であって、プロペラから空気を噴き出すように設計したもの又はプロペラに空気を供給するように設計したもののうち、定格入力が一・二五メガワットを超えるもの

(e) Among screw propeller devices which are designed so that air from the propeller is capable of being discharged or so that air is capable of being supplied to the propeller, those with a rated output exceeding 2.5 megawatts

ヘ 排水量が一、〇〇〇トン以上の船舶に使用することができる防音装置であって、ディーゼルエンジン、ディーゼル発電機、ガスタービンエンジン、ガスタービン発電機、推進電動機又は減速装置から発生する五〇〇ヘルツ未満の周波数の音響又は振動を減少するもののうち、複合型の防音台からなり、かつ、中間のマスの重量がその上に設置される装置の重量の三〇パーセントを超えるもの

(f) Among soundproofing devices which are capable of being used on vessels in which the displacement is greater than 1,000 tons which reduces sound or vibration at frequencies of less than 500 hertz generated from diesel

engines, diesel generators, gas turbine engines, gas turbine generators, propulsion electric motors, reducers, those made of a composite sound insulating base the intermediate mass weight of which exceeds 30 % of the weight of the device installed on it

ト スクリュープロペラの推進力の向上又はその水中ノイズの減少を図るために未広ノズル又は整流バーンに関する技術を用いた装置であって、出力が二・五メガワットを超えるもの

(g) Equipment which uses a divergent nozzle or which uses technology relating to a straightening vane to upgrade the driving force of the screw propeller or to reduce underwater noise in which the output exceeds 2.5 megawatts

十一 推進器の模型の周辺の水流から生じるノイズを音場において計測するために設計した回流水槽であって、基準音圧が一マイクロパスカル及び周波数幅が一ヘルツの場合において、〇ヘルツ以上五〇〇ヘルツ以下の周波数範囲での暗騒音が一〇〇デシベル未満のもの

(xi) A rotation current water tank designed to measure noise coming from the stream around a model propeller in a sound field, with a background noise of less than 100 decibels within a frequency range of 0 hertz or more and 500 hertz or less when the standard sound pressure is 1 micropascal and the frequency width is 1 hertz

十二 浮力材であって、次のイ及びロに該当するもの

(xii) Buoyant materials which fall under the following (a) and (b)

イ 一、〇〇〇メートルを超える水深で使用することができるように設計したもの

(a) Buoyant materials designed so they are capable of being used at depths exceeding 1,000 meters

ロ 密度が五六一キログラム毎立方メートル未満のもの

(b) Buoyant materials the density of which is less than 561 kilograms per cubic meter

十三 閉鎖回路式又は半閉鎖回路式の自給式潜水用具

(xiii) Closed-circuit or semi-closed circuit self-contained diving equipment

第十二条 輸出令別表第一の一三の項の経済産業省令で定める仕様のもものは、次のいずれかに該当するものとする。

Article 12 Goods with specifications prescribed by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 13 of appended table 1 of the Export Order shall fall under any of the following.

一 航空機用のガスタービンエンジンであって、次のいずれかに該当するもの

(i) Gas turbine engines for aircraft which fall under any of the following

イ 第二十五条第三項第二号イからヌまでのいずれかに該当するものの設計若しくは製造に必要な技術（プログラムを除く。）又は第二十七条第五項各号に該当するものの設計若しくは製造に必要な技術を用いたもの（本邦又は別表第二に掲げ

る地域の政府機関が民間航空機と認めた機体に使用するよう設計したものであって、同地域の政府機関から認定されているものを除く。）

(a) Gas turbine engines for aircraft using technology (excluding programs) required for design or manufacture of items which fall under any of (a) through (j) in Article 25, paragraph (3), item (ii) or technology required for design or manufacture of items which fall under the items of Article 27, paragraph (5) (excluding those designed for use in airframes approved in Japan or by the regional government organizations listed in the appended table 2 and which are approved by the same regional government organizations)

ロ マッハ数が一を超える速度における巡航時間が三〇分を超えるよう設計した航空機に使用するよう設計したもの

(b) Gas turbine engines which are designed for use in aircraft designed so that the cruising time at speeds greater than Mach 1 exceeds 30 minutes

二 船舶用のガスタービンエンジンであって、次のイ及びロに該当するもの又はその部分品

(ii) Gas turbines for vessels that fall under the following (a) and (b) or components thereof

イ 国際標準化機構の定める標準状態における連続定格出力が二四、二四五キロワット以上のもの

(a) Gas turbines for vessels, the continuous rated output of which under standard conditions determined by international standardization organizations is greater than 24,245 kilowatts

ロ 一キロワット時当たりの燃料消費量が国際規格における連続定格出力の三五パーセント以上一〇〇パーセント以下の範囲において〇・二一九キログラム以下のもの

(b) Gas turbines for vessels, with a fuel consumption per kilowatt of 0.219 kilograms or more at ranges where the continuous rated output under international standards is 35 % or more and 100 % or less

三 ガスタービンエンジンの部分品であって、第二十五条第三項第二号イからヌまでのいずれかに該当するものの設計若しくは製造に必要な技術（プログラムを除く。）又は第二十七条第五項各号に該当するものの設計若しくは製造に必要な技術を用いたもののうち、次のいずれかに該当するガスタービンエンジンに使用するよう設計したもの。

(iii) Among components of gas turbine engines using technology (excluding programs) required for designing or manufacturing those which fall under any of Article 25, paragraph (3), item (ii), (a) through (j) or technology required for designing or manufacturing those which fall under the items of Article 27, paragraph (5), those designed for use in gas turbine engines which fall under any of the following.

イ 第一号に該当するもの

(a) Components which fall under item (i)

ロ 設計した又は製造する地域が本邦若しくは別表第二に掲げる地域以外の地域であるもの又は特定できないもの

(b) Components for which the region where they were designed or manufactured is Japan or a region outside the regions indicated in appended table 2 or not specified

四 宇宙空間用の飛しょう体又はその打上げ用の飛しょう体

(iv) Spacecrafts for aerospace or spacecrafts for launching thereof

五 次号に該当するものを内蔵する液体ロケット推進装置

(v) Internally stored liquid rocket propulsion units which fall under the next item

六 液体ロケット推進装置の部分品であって、次のいずれかに該当するもの

(vi) Components of liquid rocket propulsion units which fall under any of the following

イ 極低温用の冷却装置、デュワー瓶、ヒートパイプその他の極低温用装置であって、宇宙空間用の飛しょう体又はその打上げ用の飛しょう体に使用するように設計し、かつ、極低温状態にある液体の損失が一年間につき三〇パーセント未満のもの

(a) Very low temperature cooling systems, Dewar vessels, heat pipes and other very low temperature systems which are designed for use in spacecrafts for aerospace or for spacecrafts for launching thereto and with a liquid loss at very low temperatures of less than 30 % per year

ロ 極低温用容器又は閉サイクル冷却装置であって、零下一七三度以下にすることができるもののうち、宇宙空間用の飛しょう体、打上げ用の飛しょう体又はマッハ数が三を超える速度での巡航が可能な航空機に使用することができるように設計したもの

(b) Among very low temperature containers or closed cycle cooling systems for use at temperatures of -173 degrees centigrade or less, those which are designed for use in spacecrafts for aerospace, spacecrafts for launch or aircraft which are capable of cruising at speeds exceeding Mach 3

ハ スラッシュ水素の貯蔵装置又は移送装置

(c) Storage containers or supply systems for hydrogen slush

ニ 一七・五メガパスカルを超える吐出圧のターボポンプ若しくはその部分品又は当該ターボポンプのためのガス発生器若しくはエキスパンダーサイクルタービン駆動装置

(d) Gas generators or expander cycle turbine drive units for turbine pumps or components thereof with a discharge pressure of more than 17.5 megapascals or for turbine pumps therefor

ホ 一〇・六メガパスカルを超える推力発生器又はそのノズル

(e) Propulsion generators or nozzles therefor having a thrust exceeding 10.6 megapascals

- へ 推進薬貯蔵装置であって、毛細管現象を利用したもの又はフレキシブルブラダ  
ーを用いたもの
- (f) Propellant storage equipment which utilizes capillary action or flexible  
bladders
- ト 液体燃料噴射器であって、個々のオリフィスの面積が $0.114$ 平方ミリメ  
ートル以下のもの
- (g) Liquid fuel injection devices in which individual orifice areas are  $0.114$   
square millimeters or less
- チ 炭素及び炭素繊維を用いた複合材料により一体成形された推力室又はイグジッ  
トコーンであって、密度が一・四グラム毎立方センチメートルを超えるものう  
ち、引張強さが四八メガパスカルを超えるもの
- (h) Among thrust chambers or exit cones which are formed integrally of a  
single piece using a composite material of carbon and carbon fiber, and the  
density of which is exceeding  $1.4$  grams per cubic centimeter, those the  
tensile strength of which is exceeding  $48$  megapascals
- 七 固体ロケット推進装置であって、次のいずれかに該当するもの
- (vii) Solid rocket propulsion units which fall under any of the following
- イ 総推力容量が一・一メガニュートン秒を超えるもの又は燃焼器内の圧力を七メ  
ガパスカルにした状態でノズルの出口圧力を海面レベルの大気圧にした時の比推  
力が二・四キロニュートン秒毎キログラム以上のもの
- (a) Solid rocket propulsion units, the specific impulse of which is more than  
 $2.4$  kilonewtons second per kilogram when the outlet pressure is brought to  
atmospheric pressure at sea level and the effective thrust capacity is  
greater than  $1.1$  meganewtons or when the pressure inside the combustor  
is  $7$  megapascals
- ロ ステージのマスフラクションが八八パーセントを超えるものであって、推進薬  
固体比率が八六パーセントを超えるもの
- (b) Solid rocket propulsion units in which stage mass fraction exceeds  $88\%$   
and in which propellant solid ratio exceeds  $86\%$
- ハ 次号に該当するものを内蔵したもの
- (c) Solid rocket propulsion units internally stored which fall under the next  
item
- ニ 断熱材と推進薬を接合するためのものであって、推進薬の強度以上の機械的接  
合強度を得るため又は固体推進薬とモータケースの断熱材の間の化学的移行に対  
するバリアーとするためにダイレクトボンディングモータ設計法を用いたもの
- (d) Solid rocket propulsion units used to join the insulating material and  
propellant which use direct bonding motor design methods to obtain a  
mechanical joining strength which is greater than the strength of the  
propellant or to make a barrier for the chemical migration between the  
solid propellant and the insulating material of the motor case
- 八 固体ロケット推進装置の部分品であって、次のいずれかに該当するもの

(viii) Components for solid rocket propulsion units which fall under any of the following

イ 断熱材と推進薬を接合するためのものであって、推進薬の強度以上の機械的接合強度を得るため又は固体推進薬とモータケースの断熱材の間の化学的移行に対するバリアーとするためにライナーを用いたもの

(a) Components which join insulating material and propellant and which use liners to obtain a mechanical bonding strength which is greater than the strength of the propellant and to make a barrier against chemical migration between the solid propellant and the insulating material for the motor case

ロ フィラメントワインディング法で成形された複合材を用いたモータケースであって、直径が〇・六メートルを超えるもの又は構造効率比が二五キロメートルを超えるもの

(b) Motor cases which use composite materials made using the filament winding method having a diameter greater than 0.61 meters or in which structural efficiency ratio is greater than 25 km

ハ ノズルであって、推力が四五キロニュートンを超えるもの又はノズルのスロートの侵食率が〇・〇七五ミリメートル毎秒未満のもの

(c) Nozzles the thrust of which is greater than 45 kilonewtons or in which nozzle throat erosion ratio is less than 0.075 millimeters per second

ニ 可動ノズル又は二次噴射推力方向制御装置であって、次のいずれかに該当するもの

(d) Movable nozzle or secondary injection propulsion direction control equipments which fall under any of the following

(一) 推力方向の偏向範囲の絶対値が五度を超えるもの

1. Those in which absolute value for the deflection range in the thrust vector is exceeding 5 degrees

(二) 推力方向を変化させる際の角速度が二〇度毎秒以上のもの

2. Those in which angular velocity when changing the thrust vector is greater than 20 degrees per second

(三) 推力方向を変化させる際の角加速度が四〇度毎秒毎秒以上のもの

3. Those in which angular acceleration when changing the thrust vector is greater than 40 degrees per second squared

九 ハイブリッドロケット推進装置であって、次のいずれかに該当するもの

(ix) Hybrid rocket propulsion units which fall under any of the following

イ 総推力容量が一・一メガニュートン秒を超えるもの

(a) Those total thrust capacity of which is greater than 1.1 meganewtons second

ロ 出口が真空になっている状態での推力が二二〇キロニュートンを超えるもの

(b) Those the thrust of which when the outlet is in a vacuum is greater than 220 kilonewtons



十 打上げ用の飛しょう体若しくはその推進装置又は宇宙空間用の飛しょう体の部分品であって、次のいずれかに該当するもの

**(x) Components for spacecrafts used for launching or propulsion equipment**

**thereof or spacecrafts for aerospace use which fall under any of the following**

イ 打上げ用の飛しょう体の部分品（ノーズコーン以外のものにあつては、重量が一〇キログラムを超えるものに限る。）であつて、第四条第十二号又は同条第十五号に該当する金属マトリックス複合材、有機複合材、セラミックマトリックス又は金属間化合物強化材料を用いたもの

**(a) Components of spacecrafts used for launching (limited to those other than nose cones, the weight of which exceeds 10 kilograms) metal matrix composite materials which fall under Article 4, item (xii) or Article 4, item (xv), organic composite materials, ceramic matrices or intermetallic compound reinforcing materials**

ロ 打ち上げ用の飛しょう体の推進装置の部分品であつて、第五号、第七号又は前号のいずれかに該当する推進装置に使用するように設計したもののうち、第四条第十二号又は同条第十五号に該当する金属マトリックス複合材、有機複合材、セラミックマトリックス又は金属間化合物強化材料を用いたもの（第六号又は第八号に掲げるものを除く。）

**(b) Among components of propulsion equipment of spacecrafts used for launching which are designed for use in propulsion equipment that falls under any of item (v), item (vii) or the preceding item, those using metal matrix composites, organic composites, ceramic matrices or intermetallic compound reinforcing materials which fall under Article 4, item (xii) or Article 4, item (xv) (excluding those listed in item (vi) or item (viii))**

ハ 宇宙空間用の飛しょう体の部分品であつて、構造体の動的応答又はねじれを能動的に制御するもの

**(c) Components for spacecraft for aerospace use which are used to control dynamic response for structures or to actively control torsion**

ニ 液体パルスロケットエンジンであつて、推力重量比が一キロニュートン毎キログラム以上のもののうち、応答時間が〇・〇三〇秒未満のもの

**(d) Among liquid pulse rocket engines in which the thrust weight ratio is 1 kilonewton per kilogram or more, those the response time of which is less than 0.030 seconds**

十の二 無人航空機であつて、次のイ又はロに該当するもの（娯楽又はスポーツの用に供する模型航空機を除く。）

**(x)-2 Unmanned aerial vehicles which fall under the following (a) or (b) (excluding model aircraft used for entertainment or sports)**

イ 慣性航法装置による自動操縦等により、自律的な飛行制御能力及び航行能力を有するもの

**(a) Unmanned aerial vehicles having autonomic aviation control capability and flight capability through use of an autopilot based on an inertial**

navigation device

ロ テレビモニターによる遠隔操縦等により、視認できる範囲を超えて人が飛行制御できる機能を有するもの

(b) Unmanned aerial vehicles having a function which enables human control of flight exceeding a visible range using remote control based on a television monitor.

十一 ガスタービンエンジンの鋳造によるブレード、ベーン又はティップシュラウドを製造するための装置又は工具（型を含む。）であって、次のいずれかに該当するもの

(xi) Equipment or tools (including molds) used to manufacture blades, vanes or dip shrouds by gas turbine casting which fall under any of the following

イ 一方向性凝固又は単結晶の鋳造のための装置

(a) Equipment for unidirectional solidification or for casting of single crystals

ロ セラミック製のコア又はシェル

(b) Ceramic cores or shells

十二 第二十五条第三項第二号イからヌまでのいずれかに該当するものの設計若しくは製造に必要な技術（プログラムを除く。）又は第二十七条第五項各号に該当するものの設計若しくは製造に必要な技術を用いたガスタービンエンジン又はガスタービンエンジンの部分品を設計するためのものであって、実時間で制御する装置、計測器（センサーを含む。）又は自動的にデータを収集し、解析する装置

(xii) Equipment for design of gas turbines or gas turbine components which use technology required for manufacture of items which fall under any of Article 25, paragraph (3), item (ii), (a) through (j) (excluding programs), or use technology required for design and manufacture of items which fall under the items of Article 27, paragraph (5) and real time controlling devices, measuring instruments (including sensors) or devices which collect and analyze data automatically

十三 ティップにおける周速が三三五メートル毎秒を超えるものであって、五〇〇度を超える温度において運転できるように設計したガスタービンエンジンのブラシシールの製造用の装置若しくは試験装置又はこれらの部分品

(xiii) Devices for manufacturing brush seals for gas turbine engines or test equipment or components thereof whose peripheral speed when tipped exceeds 335 meters per second and are designed so that they are capable of being operated at temperatures exceeding 500 degrees centigrade

十四 金属間化合物、超合金又はチタンからなるガスタービンエンジンの翼部とディスク部を固相接合するための工具

(xiv) Tools used for solid phase joining of wing and disk parts of gas turbine engines made of intermetallic compounds, super alloys or titanium

十五 次のいずれかに該当する風洞又は装置とともに使用するよう設計したものであって、実時間で制御する装置、計測器（センサーを含む。）又は自動的にデータを収集し、解析する装置

- (xv) Devices for real-time control, measuring instruments (including sensors) or devices which collect and analyze data automatically which are designed for use in wind tunnels or devices which fall under any of the following
- イ マッハ数が一・二以上の速度の状態を作ることができる風洞
- (a) Wind tunnels which are capable of creating conditions for velocities of Mach 1.2 or more
- ロ マッハ数が五を超える流れの環境をシミュレートすることができる装置
- (b) Equipment which is capable of simulating flow environments exceeding Mach 5
- ハ 二五、〇〇〇、〇〇〇を超えるレイノルズ数の流れをシミュレートすることができる風洞又は装置。ただし、試験用のモデルが二次元断面のものに限られるものを除く。
- (c) Wind tunnels or equipment which are capable of simulating the flow for a Reynolds number exceeding 25,000,000. However, this does not include test models which are restricted to two-dimensional sections
- 十六 音響振動試験装置であって、次のイからハまでのすべてに該当するもの又はその石英加熱器
- (xvi) Acoustic vibration test equipment which falls under all of the following (a) through (c)
- イ 基準音圧を二〇マイクロパスカルとしたときの音圧が一六〇デシベル以上のもの
- (a) Acoustic vibration test machines the sound pressure of which when the standard sound pressure is 20 micropascals is greater than 160 decibels
- ロ 定格出力が四キロワット以上のもの
- (b) Acoustic vibration test machines, the rated output of which is greater than 4 kilowatts
- ハ 試験室の温度が一、〇〇〇度を超えるもの
- (c) Acoustic vibration test machines in which the laboratory temperature exceeds 1,000 degrees centigrade
- 十七 非破壊検査技術を用いてロケットモータを検査するための装置
- (xvii) Equipment used to test rocket motors using non-destructive examination technology
- 十八 よどみ点における温度が五六〇度を超える流れの壁面摩擦を直接計測することができるように設計した変換器
- (xviii) Converters which are designed so that they are capable of directly measuring the wall friction of a flow in which temperatures at stagnation point are greater than 560 degrees centigrade
- 十九 ガスタービンエンジンの回転部分に用いられる部分品であって粉末冶金によって製造されるもののうち極限引張強さの六〇パーセント以上の応力を加えた状態で六〇〇度以上の温度で使用することができるものを製造するための工具
- (xix) Among components which are used for the rotating parts of gas turbine

engines, and manufactured using powder metallurgy, tools which are used to manufacture components which are capable of being used at temperatures of 600 degrees centigrade or more when stress is applied which have a limit tensile strength of more than 60 %

第十三条 輸出令別表第一の一四の項（一）の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

Article 13 (1) Goods with specifications prescribed by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry with row 14 (i) of appended table 1 of the Export Order shall fall under any of the following.

一 粒子が球形で、かつ、その径が六〇マイクロメートル以下のアルミニウムの粉であって、アルミニウムの純度が九九パーセント以上のものからなるもの

(i) Aluminum powder, the particles of which are globular with a diameter of 60 micrometers or less and with an aluminum purity of 99 % or more

二 粒子の径が三マイクロメートル以下の鉄（水素で酸化鉄を還元する方法を用いて製造したものに限る。）の粉であって、鉄の純度が九九パーセント以上のものからなるもの

(ii) Iron powder with a particle diameter of 3 micrometers or less (limited to those manufactured using a method which reduces iron oxide using hydrogen) and with an iron purity of 99 % or more

2 輸出令別表第一の一四の項（二）の経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

(2) Goods specified by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 14 (ii) of the appended table 1 of the Export Order shall fall under any of the following.

一 火薬又は爆薬の主成分となる物質であって、次のいずれかに該当するもの

(i) Substances having low explosives or high explosives as their major components which fall under any of the following

イ 硝酸トリアミノグアニジン

(a) Anidine triamine nitrate

ロ チタニウムサブヒドリドであって、化学量論比が〇・六五以上一・六八以下のもの

(b) Titanium subhydride with a chemically correct mixture ratio of 0.65 or more and 1.68 or less

ハ ジニトログリコルリル

(c) Dinitroglycolyl

ニ 三ニトロ一・二・四トリアゾール一五オン

(d) 3-nitro-1,2,4-triazole-5-one

ホ 硝酸ヒドラジン

(e) Hydrazine nitrate

ヘ 過塩素酸ヒドラジン

(f) Hydrazine perchlorate

ト 水酸化アンモニウムナイトレート

(g) Ammonium Nitrate

チ 水酸化アンモニウムパークロレート

(h) Ammonium Perchlorate

リ ニー（五—シアノテトラゾレート）ペンタアミンコバルト（I I I）パークロレート

(i) 2-(5-cyanotetrazolate) pentamine cobalt (111) perchlorate

ヌ シスービス（五—ニトロテトラゾレート）テトラアミンコバルト（I I I）パークロレート

(j) Cis-bis (5-nitrotetrazolate) tetra amino cobalt(III) perchlorate

ル アミノジニトロベンゾフロキササン

(k) Amino dinitrobenzofuroxan

ヲ ジアミノジニトロベンゾフロキササン

(l) Diamino dinitrobenzofuroxane

ニ 火薬若しくは爆薬の添加剤又は前駆物質となる物質であって、次のいずれかに該当するもの

(ii) Substances which are additives or precursors to low explosives or high explosives which fall under any of the following

イ アジドメチルメチルオキシタン又はその重合体

(a) Azide methyl methyl oxetane or polymers thereof

ロ 塩基性サリチル酸銅

(b) Basic copper salicylate

ハ サリチル酸鉛

(c) Lead salicylate

ニ ビス（二・二—ジニトロプロピル）フォルマール

(d) Bis (2,2-dinitropropyl) formal

ホ ビス（二・二—ジニトロプロピル）アセタール

(e) Bis (2,2-dinitropropyl) acetal

ヘ ビス（二・フルオロ—二・二—ジニトロエチル）フォルマール

(f) Bis (2,fluoro-2,2-dinitroethyl) formal

ト ビス（二—ヒドロキシエチル）グリコルアミド

(g) Bis (2-hydroxyethyl) glycol amide

チ ビス（二—メチルアジリジニル）メチルアミノホスフィンオキシド

(h) Bis (2-methyl aziridinyl) methyl amino phosphine oxide

リ ビスアジドメチルオキシタン又はその重合体

(i) Bis azide methyl oxetane or polymers thereof

ヌ ビスクロロメチルオキシタン

(j) Bis chloromethyl oxetane

ル ブタジエンニトリルオキシド

(k) Butadiene nitrile oxide

- ヲ ー・二・三—ブタントリオールトリナイトレート
- (l) 1,2,3-butanetriol trinitrate  
ワ ジニトロアゼチジンターシャリーブチル塩
- (m) Dinitro azetidine tertiary butyl salt  
カ ニトロ基、アジド基、ニトレート基、ニトラザ基又はジフルオロアミノ基を有する高エネルギーモノマー、可塑剤及び重合体
- (n) High energy monomers having a nitro group, azide group, nitrate group, nitraza group or a difluoro amino group  
ヨ ポリー二・二・三・三・四・四—ヘキサフルオロペンタン—一・五—ジオールフォルマル
- (o) Poly-2,2,3,3,4,4-hexafluoro pentane-1,5-diol formal  
タ ポリー二・四・四・五・五・六・六—ヘプタフルオロ—二—トリフルオロメチル—三—オキサヘプタン—一・七—ジオールフォルマル
- (p) Poly-2,4,4,5,5,6,6-heptafluoro-2-trifluoro methyl-3-oxaheptane-1,7-diol formal  
レ グリシジルアジドの重合体の誘導体
- (q) Derivatives of polymers of glycidyl azide  
ソ ヘキサベンジルヘキサアザイソウルツタン
- (r) Hexabenzylhexaazaisowurtzitane  
ツ 超微粉酸化第二鉄であって、表面積が一グラム当たり二五〇平方メートルを超え、かつ、粒子の径の平均が〇・〇〇三マイクロメートル以下のもの
- (s) Ultra fine powdered ferric oxide in which the surface area exceeds 250 square meters per gram and in which average particle diameter is 0.003 micrometers or less  
ネ ベーターレゾルシン酸鉛
- (t) Beta lead resorcinate resorcinol acid  
ナ すず酸鉛
- (u) Lead stannate  
ラ マレイン酸鉛
- (v) Lead maleate  
ム クエン酸鉛
- (w) Lead citrate  
ウ ベーターレゾルシン酸鉛又はサリチル酸鉛の鉛—銅のキレート
- (x) Chelate of beta lead resorcinate or lead-copper lead salicylate  
キ ニトラトメチルメチルオキセタン又は三—ニトラトメチル—三—メチルオキセタンの重合体
- (y) Polymers of nitrate methyl methyl oxetane or 3-nitrate methyl-3-methyl oxetane  
ノ 三—ニトラザ—一・五—ペンタンジイソシアネート
- (z) 3-nitraza-1,5-pentane diisocyanate  
オ 推進薬の添加剤となる有機金属のカップリング剤

(aa) Coupling agents for organic metal which are additive for propellant

ク ポリシアノジフルオロアミノエチレンオキシド

(bb) Polycyano difluoroamino ethylene oxide

ヤ ポリグリシジルニトレート又はニトラトメチルオキシランの重合体

(cc) Polymers of polyglycidyl nitrate or nitrate methyl oxylane

マ ポリニトロオルトカーボネート

(dd) Polynitro ortho carbonate

ケ プロピレンイミン

(ee) Propylene imine

フ テトラアセチルジベンジルヘキサアザイソウルツラン

(ff) Tetraacetyl benzyl hexaazoisoultrane

コ シアノエチル化ポリアミン（第三条第七号ツに掲げるものを除く。）又はシアノエチル化ポリアミンの塩

(gg) Cyanoethylated polyamine (excluding those listed in Article 3, item (vii), (s) or cyanoethylated polyamine salts

エ グリシドールを付加したシアノエチル化ポリアミン（第三条第七号ソに掲げるものを除く。）又はグリシドールを付加したシアノエチル化ポリアミンの塩

(hh) Cyanoethylated poly amine with added glycydol (excluding those listed in Article 3, item (vii), (r))

テ トリス——（二—メチル）アジリジニルホスフィンオキシドの誘導体

(ii) Derivatives of tris-1-(2-methyl) aziridinyl phosphine oxide

ア 一・二・三—トリス（一・二—ビス（ジフルオロアミノ）エトキシ）プロパン又はトリスビノキシプロパンの添加剤

(jj) Additives of 1,2,3-tris (1,2-bis (difluoro amine) ethoxy) propane or tris binoxypropane

サ 一・三・五—トリクロロベンゼン

(kk) 1,3,5-trichlorobenzene

キ 一・二・四—ブタントリオール

(ll) 1,2,4-butane triol

ユ 一・三・五・七—テトラアセチル——・三・五・七—テトラアザシクロオクタン

(mm) 1,3,5,7-tetraacetyl-1,3,5,7-tetraazocyclooctane

メ 一・四・五・八—テトラアザデカリン

(nn) 1,4,5,8-tetraazadecaline

ミ 低分子量（分子量が一〇、〇〇〇以下のものをいう。）で、かつ、アルコール官能基を有するポリエピクロロヒドリン、ポリエピクロロヒドリンジオール又はポリエピクロロヒドリントリオール

(oo) Polyepichlorohydrin, polyepichlorohydrin diol or polyepichlorohydrin triol having a low-molecular weight (molecular weight of 10,000 or less) and alcohol functional groups

3 輸出令別表第一の一四の項（三）の経済産業省令で定める仕様のものは、出力が三

七・三キロワット以上のディーゼルエンジンであって、非磁性材料で構成されている部分の重量が全重量の七五パーセント以上のもの又はその部分品とする。

(3) Goods with specifications prescribed by the Ordinance of the Ministry, Trade and Industry in row 14 (iii) of the appended table 1 of the Export Order which are diesel engines with an output of 37.3 kilowatts or more in which parts were made of non-magnetic materials weighting more than 75 % of the total weight, or components thereof.

4 削除

(4) Deleted

5 輸出令別表第一の一四の項（五）の経済産業省令で定める仕様のもは、次のいずれかに該当するものとする。

(5) Goods with specifications prescribed by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 14 (v) of the appended table 1 of the Export Order shall fall under any of the following.

一 閉鎖回路式自給式潜水用具又はその部分品

(i) Closed-circuit type self-contained diving equipment or components thereof

二 半閉鎖回路式自給式潜水用具又はその部分品

(ii) Semi-closed circuit type self-contained diving equipment or components thereof

三 自給式潜水用具の部分品であって、開放回路式自給式潜水用具を閉鎖回路式自給式潜水用具又は半閉鎖回路式自給式潜水用具に変換するために使用するよう設計したもの

(iii) Components for self-contained diving equipment, those designed for use in converting open circuit type self-contained diving equipment to closed circuit self-contained diving equipment or semi-closed circuit self-contained diving equipment

6 輸出令別表第一の一四の項（七）の経済産業省令で定める仕様のもは、ロボット（操縦ロボット及びシーケンスロボットを除く。以下この項において同じ。）若しくはロボット用の制御装置若しくはエンドエフェクターであって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品（ロボット用のエンドエフェクターであるものを除く。）とする。

(6) Goods with specifications prescribed by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 14 (vii) of appended table 1 of the Export Order shall be robots (excluding maneuvering robots and sequence robots; hereinafter the same shall apply in this paragraph) or controller or end effectors used for robots, and those which fall under the following or components thereof (excluding end effectors for robots).

一 引火点が五六六度を超える圧力油を使用することができるよう設計したもの

(i) Robots which are designed so that they are capable of using pressure oil in which ignition point is exceeding 566 degrees centigrade

二 電磁パルスによる影響を防止するよう設計したもの



- (ii) Those which are designed to prevent the effect of electromagnetic pulses
- 7 輸出令別表第一の一四の項（八）の経済産業省令で定める仕様のもは、一〇〇マイクロ秒未満のシャッター速度を有する電気制動シャッターであって、フォトクロミック作用又は電気光学効果を利用したもの（カメラ用に設計したものを除く。）とする。
- (7) Goods with specifications prescribed by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 14 (viii) of appended table 1 of the Export Order shall be electric braking shutters that have a shutter speed of less than 100 microseconds and utilize photochromic action or electro-optical effect (excluding those designed for cameras).
- 8 輸出令別表第一の一四の項（九）の経済産業省令で定める仕様のもは、次のいずれかに該当するものとする。
- (8) Goods with specifications prescribed by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 14 (ix) of appended table 1 of the Export Order shall fall under any of the following.
- 一 ブロモベンジルシアニド
  - (i) Bromobenzyl cyanide
  - 二 クロロベンザルマロノニトリル
  - (ii) Chlorobenzal malononitrile
  - 三 クロロアセトフェノン
  - (iii) Chloroacetophenone
  - 四 ジベンズー（b・f）一一・四一オキサゼビン
  - (iv) Dibenzo (b,f)-1,4-oxazebine
  - 五 ジフェニルクロロアルシン
  - (v) Diphenyl chloroarsine
  - 六 ジフェニルアミンクロロアルシン
  - (vi) Diphenyl amine chloroarsine
  - 七 ジフェニルシアノアルシン
  - (vii) Diphenyl cyanoarsine
  - 八 前各号のいずれかに該当する物質の散布、防護、探知若しくは識別のための装置又はその部分品
  - (viii) Equipment for application, protection, location or identification of substances which fall under any of the preceding items, or components thereof

第十四条 輸出令別表第一の一五の項の経済産業省令で定める仕様のもは、次のいずれかに該当するものとする。

Article 14 Goods with specifications prescribed by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 15 of the appended table 1 of the Export Order shall fall under any of the following.

- 一 第四条第十五号ハ又はニに該当する繊維を使用した成型品（半製品を含む。）で

あって、有機物をマトリックスとするもの

(i) Molded goods (including semi-manufactured goods) using fibers that fall under Article 4, item (xv), (c) or (d) and whose matrix is a organic matter

二 電波の吸収材又は導電性高分子であって、次のいずれかに該当するもの

(ii) Radio wave absorbers or conductive polymers that fall under any of the following:

イ 電波の吸収材として使用するよう設計したものであって、周波数が二〇〇メガヘルツ超三テラヘルツ未満のもの。ただし、次のいずれかに該当するものであって、塗料に混入していないものを除く。

(a) Absorbers designed to be used as radio wave absorbers and that have a frequency exceeding 200 megahertz and less than 3 terahertz. However, this shall exclude those falling under any of the following, into and not mixed into coating materials

(一) 磁性を有していない繊維状のもの

1. Non-magnetic fibrous absorbers

(二) 磁気損失により電波を吸収するものでないもの（板状のものを除く。）

2. Absorbers (excluding those which are plate shaped) that do not absorb radio waves through magnetic loss

(三) 板状の吸収材であって、次の1から3までのすべてに該当するもの

3. Plate shaped absorbers that fall under all of the following i. through iii.

1 次のいずれかに該当するものからなるもの

i. Absorbers made of any of the following

一 炭素を含有するプラスチックの発泡体を用いたもの又は有機物を用いたものであって、次のイ及びロに該当するもの

a. Absorbers that use plastic foams containing carbon or organic matter and fall under 1 or 2

イ 吸収率が最大である電波の周波数を中心としたプラスマイナス五パーセントの周波数範囲以外の周波数において測定した当該吸収材の電波の反射率が金属板の電波の反射率の五パーセント以上のもの

1 Absorbers having radio wave reflectivity, measured for frequencies other than the frequency range of plus/minus 15% centered on the radio wave frequency for which absorption is a maximum, of 5% or more of the electric wave reflectivity of a metal plate.

ロ 一七七度を超える温度で使用することができないもの

2 Absorbent that can not be used under exceeding 177 degrees centigrade

二 セラミックを用いたものであって、次のイ及びロに該当するもの

b. Absorbers that use ceramics and fall under the following 1 and 2

イ 吸収率が最大である電波の周波数を中心としたプラスマイナス五パーセントの周波数範囲以外の周波数において測定した当該吸収材の電波の反射率が金属板の電波の反射率の二〇パーセント以上のもの

1 Absorbers having radio wave reflectivity, measured for frequencies

other than the frequency range of plus/minus 15% centered on the radio wave frequency for which absorption is a maximum, of 20% or more of the electric wave reflectivity of a metal plate.

ロ 五二七度を超える温度で使用することができないもの

2 Absorbers that can not be used at temperatures exceeding 527 degrees centigrade

2 引張強さが七メガニュートン毎平方メートル未満のもの

ii. Absorbers with a tensile strength less than 7 meganewtons per square meter

3 圧縮強さが一四メガニュートン毎平方メートル未満のもの

iii. Absorbers with a compression strength less than 14 meganewtons per square meter

(四) 焼結したフェライトからなる板状の吸収材であって、次の1及び2に該当するもの

4. Absorbers made of sintered ferrites that fall under the following i. and ii.

1 比重が四・四を超えるもの

i. Absorbers with the specific gravity exceeding 4.4

2 二七五度を超える温度で使用することができないもの

ii. Absorbers that can not be used under temperatures exceeding 275 degrees centigrade

ロ 電波の吸収材として使用するよう設計したものであって、周波数が一五〇テラヘルツ超三七〇テラヘルツ未満のもののうち、可視光を透過しないもの

(b) Among optically non-transparent absorbers designed for the use as radio wave absorbers with the frequency exceeding 150 terahertz and less than 370 terahertz, those that do not transmit visible light

ハ 導電性高分子であって、体積導電率が一〇キロジーメンズ毎メートルを超えるもの又は表面抵抗率が一〇〇オーム未満のもののうち、次のいずれかの重合体からなるもの

(c) Among absorbers that are conductive polymers with volume conductivity exceeding 10 kilosiemens per meter or surface electrical resistivity less than 100 ohms, those comprising any of the following polymers

(一) ポリアニリン

1. Polyaniline

(二) ポリパイロール

2. Polypyrole

(三) ポリチオフェン

3. Polythiophene

(四) ポリフェニレンビニレン

4. Polyphenylene vinylene

(五) ポリサイニレンビニレン

5. Polyethylene vinylene

三 あらかじめ分離されたネプツニウム二三七であって、重量が一グラムを超えるもの

(iii) Pre-separated neptunium 237 with a weight exceeding 1 gram

四 削除

(iv) Deleted

五 チャネルの数が一、〇〇〇を超えるデジタル制御方式の無線受信機（民生用のセルラー無線通信に使用するよう設計したものを除く。）又はその部分品若しくは附属品であって、次のイからハまでのすべてに該当するもの

(v) Digitally controlled radio receivers with exceeding 1,000 channels (excluding those designed for the use in public cellular wireless communication) or components or accessories thereof that fall under all of the following (a) through (c)

イ 電磁波スペクトラムを自動的に走査することができるもの

(a) Receivers capable of automatically scanning the electromagnetic spectrum

ロ 受信信号又は送信波の種類を特定することができるもの

(b) Receivers capable of specifying the type of signals received and waves transmitted

ハ 周波数切換所要時間が一ミリ秒未満のもの

(c) Receivers in which the time required for frequency switching is less than 1 millisecond

六 音波（超音波を含む。）を利用した水中探知装置又はその部分品のうち、次のいずれかに該当するもの

(vi) Among underwater acoustic equipment utilizing acoustic waves (including ultrasound) or components thereof and that fall under any of the following

イ ハイドロホンであって、次のいずれかに該当するもの

(a) Hydrophones that fall under any of the following

(一) 可撓性を有するセンサーを組み込んだもの

1. Hydrophones that incorporate flexible sensors

(二) 可撓性を有し、直径又は長さが二〇ミリメートル未満であるセンサーを二〇ミリメートル未満の間隔で結合したものを組み込んだもの

2. Hydrophones that incorporate devices consisting of flexible sensors less than 20 millimeters in diameter or length connected at intervals less than 20 millimeters

(三) 次のいずれかの検出素子を有するもの

3. Hydrophones that have any of the following detecting elements

1 光ファイバー

i. Optical fibers

2 圧電高分子膜（ふっ化ビニリデン樹脂又はその共重合体を除く。）

ii. Piezoelectric polymer membrane (excluding vinylidene fluoride resin and copolymers thereof)

- 3 可撓性を有する圧電複合材料
- iii. Flexible piezoelectric composite materials
- (四) 一、〇〇〇メートルを超える水深で使用することができるように設計したもの
4. Hydrophones designed for the use at water depths exceeding 1,000 meters
- (五) 加速度による影響を補正する機能を有するものであって、三五メートルを超える水深で使用することができるように設計したもの
5. Hydrophones that have the function of compensating for the effects of acceleration and designed for the use at water depths exceeding 35 meters
- ロ えい航ハイドロホンアレーであって、次のいずれかに該当するもの
- (b) Towed hydrophone arrays that fall under any of the following
- (一) ハイドロホングループの間隔（隣接する二のハイドロホングループの中心間の距離をいう。以下この号において同じ。）が一・五メートル未満のもの又は一・五メートル未満に変更できるもの
1. Arrays in which the hydrophone group interval (referring to the distance between the centers of two adjacent hydrophone groups; hereinafter the same shall apply in this item) is less than 12.5 meters or those wherein the interval can be altered to less than 12.5 meters
- (二) 三五メートルを超える水深で使用することができるように設計したもの又は改造できるもの
2. Arrays designed to be capable of use at water depths exceeding 35 meters or that can be so modified
- (三) 第九条第一号ロ（三）に該当するヘディングセンサーを有するもの
3. Arrays having a heading sensor that falls under Article 9, item (i), (b), 3.
- (四) 長軸方向に強化したアレーホースを有するもの
4. Arrays having array hoses reinforced in the long axis direction
- (五) アレーの直径が四〇ミリメートル未満のもの
5. Arrays with diameter less than 40 millimeters
- (六) ハイドロホングループの信号を多重化して処理することができるものであって、三五メートルを超える水深で使用することができるように設計したもの又は三五メートルを超える水深で使用することができるように調整若しくは取り外しをすることができる水深測定装置を有するもの
6. Arrays capable of processing by multiplexing the hydrophone group signals and designed to be capable of use at water depths exceeding 35 meters or those having a depth sounding device that can be adjusted or removed to make the array capable of use at water depth exceeding 35 meters
- (七) イ又は第九条第一号ロ（一）に該当するハイドロホン有するもの
7. Arrays that have hydrophones that fall under (a) or Article 9, item (i),

(b), 1.

ハ えい航ハイドロホンアレー用に設計した信号処理装置であって、使用者によるプログラムの書換えが可能なもののうち、時間領域又は周波数領域の処理又は相関（スペクトル分析、デジタルフィルタリング又はビーム成形を含む。）を実時間処理できるもの

(c) Among signal processors designed for towed hydrophone arrays and capable of being reprogrammed by the user, those which are capable of real-time processing of process or correlation of the time domain or the frequency domain (including spectral analysis, digital filtering or beam formation)

ニ 海底用又は港湾用ケーブルシステムであって、次のいずれかに該当するもの

(d) Ocean bottom or harbor/bay cable systems that fall under any of the following

(一) イ又は第九条第一号ロ（一）に該当するハイドロホンを組み込んだもの

1. Cable systems that incorporate hydrophones that fall under (a) or Article 9, item (i), (b), 1.

(二) ハイドロホングループの信号を多重化して処理することができるものであって、次の1及び2に該当するもの

2. Cable systems that can process by multiplexing hydrophone group signals and that fall under the following i. and ii.

1 三五メートルを超える水深で使用することができるように設計したもの又は三五メートルを超える水深で使用することができるように調整若しくは取り外しをすることができる水深測定装置を有するもの

i. Cable systems designed to be capable of use at water depths exceeding 35 meters or those having a depth sounding device that can be adjusted or removed to be used at water depths exceeding 35 meters to make the array capable of use at water depth exceeding 35 meters

2 えい航ハイドロホンアレーとして転用できるもの

ii. Cable systems that can be converted into a towed hydrophone array

ホ 海底用又は港湾用ケーブルシステム用に設計した信号処理装置であって、使用者によるプログラムの書換えが可能なもののうち、時間領域又は周波数領域の処理又は相関（スペクトル分析、デジタルフィルタリング又はビーム成形を含む。）を実時間処理できるもの

(e) Among signal processors reprogrammable by the user and designed for the use in ocean bottom or a harbor/ bay cable system, which are capable of real-time processing of process or correlation of the time domain or the frequency domain (include spectrum analysis, digital filtering or beam formation)

ヘ 送信機能を有する水中探知装置であって、動作周波数が三〇ヘルツ以上二キロヘルツ以下のもののうち、音圧レベルが二一〇デシベルを超えるもの

(f) Among underwater acoustic equipment having transmission functions and

- an operating frequency range of 30 hertz or more and 2 kilohertz or less, those with the sound pressure levels exceeding 210 decibels
- 七 宇宙用に設計した固体の光検出器（ゲルマニウム又はシリコンを用いたものを除く。）であって、一、二〇〇ナノメートル超三〇、〇〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの
- (vii) Solid optical detectors designed for space applications (excluding those that use germanium or silicon) with the maximum sensitivity within the range exceeding 1,200 nano meters to 30,000 nano meters or less
- 八 レーダーであって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品
- (viii) Radars that fall under any of the following or components thereof
- イ 目標の波形又は像の特徴から目標を自動的に識別するデータ処理技術を利用するレーダー（二次監視レーダー、衝突防止用に設計した自動車レーダー、解像度が一メートル当たり一二本以下の航空管制用の表示装置及び気象レーダーを除く。）
- (a) Radars that utilize data processing technology that can identify a target automatically, from the characteristics of the target waveforms or images (excluding secondary monitor radars, automobile radars designed for collision prevention, and display equipment for air traffic control in which image resolution is 12 pixels or less per 1 meter or weather radar)
- ロ パルスレーダー断面積計測装置であって、送信するパルス幅が一〇〇ナノ秒以下のもの
- (b) Pulse radar cross-section area measuring devices with pulse duration transmitted of 100 nanoseconds or less
- 九 繫索式でない潜水艇であって、次のいずれかに該当するもの
- (ix) Untethered submersible vessels that fall under any of the following
- イ 有人式の潜水艇であって、次のいずれかに該当するもの
- (a) Manned submersible vessels that fall under any of the following
- (一) 自律的に潜航することができるように設計した潜水艇であって、次の1及び2の揚荷能力を有するもの
1. Submersible vessels designed to be capable of independent submerged travel submerged and that possess a load lifting capability of the following i. and ii.
- 1 当該潜水艇の空中重量の一〇パーセント以上
- i. 10% or more of the weight-in-air of the said submersible vessel
- 2 十五キロニュートン以上
- ii. 15 kilonewtons or more
- (二) 一、〇〇〇メートルを超える水深で使用することができるように設計したもの
2. Submersible vessels designed for the use at water depths exceeding 1,000 meters
- (三) 次の1から4までのすべてに該当するもの

3. Submersible vessels that fall under all of following i. through iv
  - 1 四人以上の乗組員が乗ることができるように設計したもの
  - i. Submersible vessels designed for 4 or more passengers
    - 2 一〇時間以上自律的に潜航することができるように設計したもの
    - ii. Submersible vessels designed to be capable of independent submerged travel for 10 hours or more
      - 3 潜航可能な距離が五〇海里以上のもの
    - iii. Submersible vessels capable of traveling submerged for a distance of 50 nautical miles or more
      - 4 長さが二メートル以下のもの
    - iv. Submersible vessels with a length of 21 meters or less
  - ロ 無人式の潜水艇であって、次のいずれかに該当するもの
- (b) Unmanned submersible vessels that fall under any of the following
  - (一) あらゆる地形に対して自動的に針路を決定することができるように設計したもの
    1. Unmanned submersible vessels designed to automatically determine their own course over all types of seafloor terrain
    - (二) 音波によってデータ又は指令を送受することができるもの
    2. Unmanned submersible vessels capable of transmitting and receiving data or command by acoustic waves
    - (三) 長さが一、〇〇〇メートルを超える光ファイバーによってデータ又は指令を送受することができるもの
    3. Unmanned submersible vessels capable of transmitting and receiving data or commands by optical fiber exceeding 1,000 meters in length
- 十 排水量が一、〇〇〇トン以上の船舶に使用することができる防音装置又は磁気軸受であって、次のイ及びロに該当するもの
- (x) Sound proofing devices or magnetic bearings capable of being used for vessels with whose displacement 1,000 tons or more, and that fall under the following (a) and (b)
  - イ 伝動装置に使用できるように設計したもの
  - (a) Sound proofing devices or magnetic bearings designed for the use in transmission gears
    - ロ 振動源に対して直接的に対抗振動を発生させることにより能動的に防音することができる電子制御装置を有するもの
  - (b) Sound proofing devices or magnetic bearings that have electronic controllers that actively provide soundproofing by directly generating counter vibrations against the source of the vibration
- 十一 ラムジェットエンジン、スクラムジェットエンジン若しくは複合サイクルエンジン又はこれらの部分品
- (xi) Ramjet engines, scramjet engines, combined cycle engines, or components thereof



第十四条の二 輸出令別表第一の一六の項（一）の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

Article 14-2 Goods with specifications prescribed by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 16 (i) of the appended table 1 of the Export Order shall fall under any of the following.

一 ニッケル合金又はチタン合金であって、次のイ及びロに該当するもの

(i) Nickel alloys or titanium alloys that fall under the following (a) and (b)

イ 三〇〇度を超える温度で使用するために特に設計したもの

(a) Alloys especially designed to be used at a temperature exceeding 300 degrees centigrade

ロ 塊、棒、型材、線、板又は管のいずれかの形状のもの

(b) Alloys shaped as any of blocks, bars, characteristic shapes, plates or tubes

二 作動油として使用することができる液体であって、りん酸とクレゾールとのエステル、りん酸トリス（ジメチルフェニル）又はりん酸トリノルマルブチルを含むもの

(ii) Liquids that can be used as hydraulic oil, which contain ester composed of phosphoric acid and cresol, phosphoric acid, Tris (dimethylphenyl) or Tri-nbutyl phosphate

三 繊維であって、次のいずれかに該当するもの

(iii) Fibers falling under any of the following

イ 有機繊維（天然繊維及びポリエチレン繊維を除く。）

(a) Organic fibers (excluding natural fibers and polyethylene fibers)

ロ 炭素繊維

(b) Carbon fibers

ハ 無機繊維

(c) Inorganic fibers

四 転がり軸受であって、三〇〇度を超える温度で使用するために特に設計したもの又はその部分品

(iv) Roller bearings especially designed to be used at a temperature exceeding 300 degrees centigrade, or components thereof

五 工作機械その他の装置であって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品

(v) Machine tools and other devices that fall under any of the following, or components thereof

イ 工作機械（金属、セラミックス又は複合材料を加工することができるものに限る。）であって、電子制御装置を取り付けることができるもののうち、次のいずれかに該当するもの

(a) Machine tools (limited to those capable of processing metals, ceramics and composite materials) to which an electronic controller can be attached and which fall under any of the following

（一） 国際規格 I S O 二三〇／二（一九八八）で定める測定方法により直線軸

の全長について測定したときの位置決め精度が○. ○一ミリメートル未満のもの

1. Tools in which the precision of positioning of the rectilinear axes is less than 0.01 millimeters when measured by the measurement method specified by International Standard ISO 230-2:1988

(二) 輪郭制御をすることができる回転軸を有するもの

2. Tools having 1 axis capable of controlling contour

ロ 鏡面仕上げを行うために特に設計したもの（数値制御を行うことができるものを除く。）

(b) Tools and devices especially designed to perform mirror finish (excluding those capable of numerical control)

ハ 測定装置（工作機械であって、測定装置として使用することができるものを含む。）であって、測定軸の数が三以上のもの

(c) Measurement equipment (including machine tools with a measurement function), with 3 or more measurement axes

六 二次セルであって、正極と負極の間をリチウムイオンを移動させることにより充電及び放電ができるように特に設計したもの

(vi) Secondary cells especially designed to perform charge and discharge by moving lithium-ion between the positive electrode and the negative electrode

七 デジタル方式の波形記憶装置

(vii) Digital waveform digitizers

八 電子部品実装ロボット

(viii) Electronic packaging robots

九 デジタル電子計算機であって、加重最高性能が○. 五実効テラ演算を超えるもの又はその部分品

(ix) Digital computers of which Adjusted Peak Performance exceeds 0.5 Weighted TeraFLOPS, or components thereof

十 伝送通信装置であって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品

(x) Telecommunication transmission equipment falling under any of the following, or components thereof

イ 無線送信機

(a) Wireless transmitters

ロ 無線受信機

(b) Wireless receivers

十一 フェーズドアレーアンテナ

(xi) Phased array antennas

十二 通信妨害装置であって、無線通信システムに干渉し若しくは阻害し、途絶させ、減退させ、若しくは誘引するように設計したもの又はその部分品

(xii) Communication jamming equipment especially designed to interfere with or inhibit wireless communication systems and block, reduce or induce communications, or components thereof

十三 電波その他の電磁波を発信することなく、電波その他の電磁波の干渉を観測することにより位置を探知することができる装置

(xiii) Equipment capable of detecting the position of objects by observing interferences of radio waves or other electromagnetic waves, without transmitting radio waves or other electromagnetic waves

十四 光検出器若しくはその冷却器若しくは部分品又は光検出器を用いた装置

(xiv) Optical detectors, or coolers or components thereof, or equipment which uses optical detectors

十五 センサー用の光ファイバー

(xv) Optical fibers for use in sensors

十六 レーザー発振器又はその部分品

(xvi) Laser oscillators or components thereof

十七 磁力計、水中電場センサー若しくは磁場勾配計又はこれらの部分品

(xvii) Magnetometers, underwater electric field sensors or magnetic field gradiometers, or components thereof

十八 重力計

(xviii) Gravimeters

十九 レーダー又はその部分品

(xix) Radars or components thereof

二十 加速度計又はその部分品

(xx) Accelerometers or components thereof

二十一 ジャイロスコープ又はその部分品

(xxi) Gyroscopes or components thereof

二十二 慣性航法装置その他の慣性力を利用する装置又はこれらの部分品

(xxii) Inertial navigation systems and other systems utilizing inertia force, or components thereof

二十三 ジャイロ天測航法装置、天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置、衛星航法システムからの電波受信装置若しくはその部分品又は航空機用の高度計

(xxiii) Gyro-astro compasses, devices that derive position or orientation by means of automatically tracking celestial bodies or satellites., equipment for receiving radio waves from satellite navigational systems or components thereof, or aircraft altimeters

二十四 水中用のカメラ又はその附属装置であって、次のいずれかに該当するもの  
(xxiv) Underwater cameras or auxiliaries thereof, which fall under any of the following

イ 水中用のテレビカメラ

(a) Underwater television cameras

ロ 水上船若しくは潜水艇に搭載して遠隔操作することができるように設計した水中テレビジョン装置

(b) Underwater television devices which are designed so that they are

capable of being mounted onto surface ships or submersible vessels for remote control

ハ 水中で用いるために特に設計若しくは改造されたカメラ又は照明装置

(c) Cameras or lighting systems especially designed or modified for use under water

二十五 大気から遮断された状態で使用することができる動力装置であつて、次のいずれかに該当するもの

(xxv) Power units which are capable of being used when they are cut off from the air, which fall under any of the following

イ ブレイトンサイクルエンジン

(a) Brayton cycle engines

ロ ディーゼルエンジン

(b) Diesel engines

ハ 燃料電池

(c) Fuel cells

ニ スターリングサイクルエンジン

(d) Sterling cycle engines

二十六 開放回路式の自給式潜水用具又はその部分品

(xxvi) Open circuit type self-contained diving equipment or components thereof

二十七 ガスタービンエンジン又はその部分品

(xxvii) Gas turbine engines or components thereof

二十八 ロケット推進装置（火薬類取締法施行規則（昭和二十五年通商産業省令第八十八号）第一条の五第一号に規定されているがん具用煙火を用いたものを除く。）又はその部分品

(xxviii) Rocket propulsion units (excluding those using toy fireworks prescribed in Article 1-5, item (i) of the Ordinance for Enforcement of the Explosives Control Act (Ordinance of the Ministry of International Trade and Industry No. 88 of 1950)) or components thereof

二十九 前二号のいずれかに掲げるものの製造用の装置であつて、次のいずれかに該当するもの又はその部分品

(xxix) Equipment for the manufacture of the goods listed in any of the preceding two items, which falls under any of the following, or components thereof

イ 真空誘導炉又は不活性ガスを用いる誘導炉

(a) Vacuum induction furnaces or induction furnaces utilizing non-volatile gases

ロ 電子ビームを用いる溶接装置

(b) Welding equipment using electron beams

三十 航空機又はその部分品

(xxx) Aircrafts or components thereof

三十一 ロケット若しくは航空機の開発若しくは試験に用いることができる振動試験

装置、風洞、環境試験装置又はこれらの部分品  
(xxxix) Vibration test equipment, wind tunnels, environmental test equipment  
or components thereof that can be used for the development or testing of  
rockets or aircrafts

三十二 フラッシュ放電型のエックス線装置（医療用のものを除く。）

(xxxii) Flash X-ray generators (excluding those for medical use)

(外国為替令別表関係)

(Foreign Exchange Order, pertaining to the Appended Table)

第十五条 外国為替令（以下「外為令」という。）別表の二の項（一）の経済産業省令  
で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

Article 15 (1) The technology specified by the Ordinance of the Ministry of  
Economy, Trade and Industry in row 2 (i) of the appended table of the Foreign  
Exchange Order (hereinafter referred to as "Foreign Exchange Order") shall  
fall under any of the following.

一 第一条第一号から第五号まで、第六号（核燃料物質の成型加工用の装置に限  
る。）、第七号、第八号イ、第十号イ、第十号の二又は第十号の三のいずれかに該  
当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術

(i) The technology pertaining to the design, manufacture or use of goods that  
fall under any of Article 1, item (i) through item (v), item (vi) (limited to the  
devices of mold processing of nuclear fuels), item (vii), item (viii), (a), item (x),  
(a), item (x)-2, or item (x)-3

二 第一条第十一号、第十七号、第十八号ロ若しくはハ、第十九号、第二十号、第二  
十一号イ若しくはロ（一）若しくは（三）、第三十四号若しくは第三十五号のい  
ずれかに該当する貨物を使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設  
計、製造若しくは使用に係る技術（プログラムを除く。）のうち、当該貨物の有す  
る機能若しくは特性に到達し、又はこれらを超えるために必要な技術

(ii) Among programs designed for the use of goods that fall under any of Article  
1, item (xi), item (xvii), item (xviii), (b) or (c), item (xix), item (xx), item (xxi),  
(a) or (b), 1. or 3. or item (xxxv) or item (xxxvi), or technologies (excluding  
programs) pertaining to the design, manufacture, or use of such programs,  
those necessary to attain or exceed the functions or characteristics of the  
goods

三 第一条第十四号に該当する貨物を設計し、製造し、若しくは使用するために設計  
したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術（プログ  
ラムを除く。）のうち、当該貨物の有する機能若しくは特性に到達し、又はこれら  
を超えるために必要な技術

(iii) Among programs designed for the design, manufacture or use of goods that  
fall under Article 1, item (xiv), or technologies (excluding programs)  
pertaining to the design, manufacture, or use of those programs, the  
technology necessary to attain or exceed the functions or characteristic of

those goods

四 第一条第八号ロ、第九号、第十号ロ、第十一号、第十四号、第十七号から第二十四号まで、第二十六号から第二十八号まで、第三十号から第五十号まで、第五十二号、第五十四号から第五十八号まで又は第六十号のいずれかに該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術（プログラムを除く。）のうち、当該貨物の有する機能若しくは特性に到達し、又はこれらを超えるために必要な技術

(iv) Among technologies (excluding programs) pertaining to the design, manufacture, or use of goods that fall under any of Article 1, item (viii), (b), item (ix), item (x), (b), item (xi), item (xiv), from item (xvii) through item (xxiv), from item (xxvi) through (xxviii), from item (xxx) through item (l), item (lii), from item (liv) through item (lviii), or item (lx), the technology necessary to attain or exceed the functions or characteristics of those goods

五 第一条第六号（リチウムの同位元素の分離用の装置に限る。）、第二十五号、第二十九号、第五十三号又は第五十九号のいずれかに該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術（プログラムを除く。）

(v) The technology (excluding programs) pertaining to the design, manufacture or use of goods that fall under any of Article 1, item (vi) (limited to the device for separation lithium isotopes), item (xxv), item (xxix), item (liii) or item (lix)

2 外為令別表の二の項（二）の経済産業省令で定める技術は、数値制御装置として機能することを可能にするプログラムであって輪郭制御をすることができる軸数が五以上のもの又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術（プログラムを除く。）のうち、輪郭制御をすることができる軸数が五以上の数値制御を可能にするために必要な技術とする。

(2) The technology specified by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 2 (ii) of the appended table of the Foreign Exchange Order shall be, among those pertaining to programs that enable a device to function as numerically-controlled coordinate measuring equipment with 5 or more axes capable of contour control or the technology (excluding programs) for design, manufacture or use of those programs, technology necessary for enabling the numerical-control of 5 or more axes capable of contour control.

第十五条の二 外為令別表の三の項（二）の経済産業省令で定める技術は、第二条第二項に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術のうち、当該貨物の有する機能若しくは特性に到達し、又はこれらを超えるために必要な技術とする。

Article 15-2 The technology specified by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 3 (ii) of the appended table of the Foreign Exchange Order shall be, among those pertaining to the design, manufacture, or use of goods that fall under Article 2, item (ii), technology necessary to attain or exceed the functions or characteristics of the goods.

第十五条の三 外為令別表の三の二の項（二）の経済産業省令で定める技術は、第二条の二第二項に該当する貨物の設計又は製造に係る技術のうち、当該貨物の有する機能若しくは特性に到達し、又はこれらを超えるために必要な技術とする。

Article 15-3 The technology specified by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 3-2 (ii) of the appended table of the Foreign Exchange Order shall be, among those pertaining to the design or manufacture of goods that fall under Article 2-2, paragraph (2), technology necessary to attain or exceed the functions or characteristics of the goods.

第十六条 外為令別表の四の項（一）の経済産業省令で定める技術は、第三条に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術のうち、次のいずれかに該当するものであって、当該貨物の有する機能若しくは特性に到達し、又はこれらを超えるために必要な技術とする。

Article 16 (1) The technology specified by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 4 (i) of the appended table of the Foreign Exchange Order shall be, among those pertaining to the design, manufacture, or use of goods that fall under Article 3, technology that falls under any of the following and is necessary to attain or exceed the functions or characteristics of the said goods.

一 五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは第三条第二号ロに該当する貨物の製造用の装置若しくは工具（型を含む。以下この条において同じ。）、試験装置若しくはこれらの部分品若しくは同号イ（二）若しくはロ（四）から（六）までのいずれかに該当する貨物を使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術（プログラムを除く。）

(i) Programs designed for the use of rockets capable of transporting a payload of 500 kilograms or more over a distance of 300 kilometers or more or equipment or tools (including molds; hereinafter the same shall apply in this Article) for manufacturing goods that fall under Article 3, item (ii), (b) or test equipment therefor, or the components thereof, or goods that fall under any of (a), 2. or (b), 4. through 6. of the same item, or technology (excluding programs) pertaining to the use, manufacturing or design of those programs.

二 五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットを使用するために設計したプログラムであって、二つ以上の貨物（第三条第二号イ又はロに該当するものに限る。）の機能を調整することができるもの又はその設計、製造若しくは使用に係る技術（プログラムを除く。）

(ii) Programs designed for the use of rockets capable of carrying a payload of 500 kilograms or more a distance of 300 kilometers or more, and which can adjust the functions of two or more goods (limited to those that fall under Article 3, item (ii), (a), or (b)) or the technology (excluding programs) pertaining to the design, manufacture or use thereof

三 第三条第二号イに該当する貨物の製造用の装置若しくは工具、試験装置若しくはこれらの部分品を設計し、製造し、若しくは使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術（プログラムを除く。）

(iii) Programs designed for the design, manufacture or use of equipment or tools for manufacturing the goods that fall under Article 3, item (ii), (a), the test equipment therefor or the components thereof, or technology (excluding programs) pertaining to the design, manufacture or use of those programs

四 五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくはその製造用の装置若しくは工具、試験装置若しくはこれらの部分品又は第三条第二号に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術（プログラムを除く。）

(iv) The technology (excluding programs) pertaining to the design, manufacture or use of rockets capable of carrying a payload of 500 kilograms or more for over 300 kilometers, or manufacturing devices or tools, test equipment, or components therefor or goods that fall under Article 3, item (ii)

五 第三条第三号イからリまでのいずれかに該当する貨物の製造用の装置若しくは工具、試験装置若しくはこれらの部分品若しくは同号イ、ロ、ト若しくはチ、第四号から第六号まで、第十一号、第十七号から第十九号まで、第二十一号イ、第二十二号若しくは第二十五号のいずれかに該当する貨物を使用するために設計したプログラム又はそのプログラム設計、製造若しくは使用に係る技術（プログラムを除く。）

(v) Programs designed for the use of equipment for manufacturing goods that fall under any of Article 3, item (iii), (b) through (i) or tools or test equipment therefor or components thereof or goods that fall under any of (a), (b), (g) or (h) of the same item, or item (iv) through item (vi), item (xi), item (xvii) through item (xix), item (xxi), (a), item (xxii) or item (xxv) or technology (excluding programs) pertaining to the design, manufacture or use of those programs

六 ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機（五〇〇キログラム以上のペイロードを運搬することができるものを除く。）又は第三条第三号から第二十七号までのいずれかに該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術（プログラムを除く。）

(vi) The technology (excluding programs) pertaining to the design, manufacture or use of rockets or unmanned aircraft that are capable of carrying a payload over a distance of 300 kilometers or more (excluding those capable of carrying a payload of 500 kilograms or more) or the goods that fall under any of Article 3, item (iii) through item (xxvii)

七 第三条第三号ロ、ハ、ホ若しくはへ若しくは第四号に該当する貨物を設計するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術（プログラムを除く。）

(vii) The technology (excluding programs) pertaining to programs designed for



- the design of the goods that fall under Article 3, item (iii), (b), (c), (e) or (f), or item (iv), or the design, manufacture, or use of those programs
- 八 第三条第八号から第十号の二までのいずれかに該当する貨物を使用するために設計したプログラム
- (viii) Programs designed for the use of goods that fall under any of Article 3, item (viii) through item (x)-2
- 九 第三条第十三号から第十五号まで若しくは第二十六号のいずれかに該当する貨物を設計し、製造し、若しくは使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術（プログラムを除く。）
- (ix) Programs designed for the design, manufacture, or use of goods that fall under any of Article 3, item (xiii) through item (xv) or item (xxvi) or technology (excluding programs) pertaining to the design, manufacture, or use of those programs
- 十 第三条第十七号イ若しくはへ若しくは第十七号の二に該当する貨物を設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術（プログラムを除く。）
- (x) Programs designed for the design or manufacture of goods that fall under Article 3, item (xvii), (a) or (f) or item (xvii)-2 or technology (excluding programs) pertaining to the design, manufacture, or use of those programs
- 十一 五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット、第三条第二号イに該当する貨物（五〇〇キログラム以上のペイロードを運搬することができるロケットに使用することができるものに限る。）若しくは同号ロに該当する貨物を設計するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術（プログラムを除く。）
- (xi) Programs designed for the design of rockets capable of carrying a payload of 500 kilograms or more over a distance of 300 kilometers or more, or goods that fall under Article 3, item (ii), (a) (limited to those capable of being used for rockets capable of transporting a payload of 500 kilograms or more) or goods that fall under (b) of the same item, or technology (excluding programs) for the design, manufacture, or use of those programs
- 十二 ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットを使用するために設計したプログラムであって、二つ以上の貨物（第三条第二号イに該当するものに限る。）の機能を調整することができるもの（第二号に該当するものを除く。）
- (xii) Programs that are designed for the use of rockets capable of carrying a payload over a distance of 300 kilometers and are capable of adjusting the functions of 2 or more goods (limited to those that fall under Article 3, item (ii), (a)) (excluding those that fall under item (ii))
- 2 外為令別表の四の項（二）の経済産業省令で定める技術は、ロケット用のアビオニクス装置又はその部分品の設計に係る技術であって、電磁パルス又は電磁障害の影響を防止するためのもの（プログラムを除く。）とする。

(2) The technology specified by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 4 (ii) of the appended table of the Foreign Exchange Order, shall be technology (excluding programs) pertaining to the design of rocket avionics equipment or components thereof and used for preventing the impact of electromagnetic pulses or electromagnetic interference.

3 外為令別表の四の項（三）の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

(3) The technology specified by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 4 (iii) of the appended table of the Foreign Exchange Order shall fall under any of the following.

一 五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットの軌道を最適化するために、飛行制御、誘導又は推進に係るデータを飛行管理装置に統合するための技術（プログラムを除く。）

(i) The technology (excluding programs) that integrates data pertaining to flight control, guidance or propulsion into the flight control device, in order to optimize the flight path of rockets capable of carrying a payload of 500 kilograms or more over a distance of 300 kilometers or more

二 飛行時に記録されたデータを処理して飛行時の全経路にわたる機体の位置決定を可能にするプログラム（ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。）又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術（プログラムを除く。）

(ii) Programs that enable the determination of the position of an airframe over its entire route during flight by processing the data recorded during flight (limited to programs that can be used for rockets or unmanned aerial vehicles that are capable of carrying a payload for over 300 kilometers) or technology (excluding programs) pertaining to the design, manufacture, or use of those programs

4 外為令別表の四の項（四）の経済産業省令で定める技術は、オートクレーブの使用に係る技術であって、オートクレーブ内部の環境を規定するためのデータ又は手順（第三条第十六号に該当する貨物を使用するためのものに限る。）とする。

(4) The technology specified by the Ordinance of Ministry of Economy, Trade and Industry in row 4 (iv) of the appended table of the Foreign Exchange Order shall be technology pertaining to the use of autoclaves, and the data or procedures to provide for the environment inside the autoclaves (limited to those that use goods that fall under Article 3, item (xvi)).

5 外為令別表の四の項（五）の経済産業省令で定める技術は、原料ガスの熱分解（一、三〇〇度以上二、九〇〇度以下の温度範囲において、かつ、一三〇パスカル以上二〇、〇〇〇パスカル以下の絶対圧力の範囲において行うものに限る。）により生成する物質を基材に定着させるための技術とする。

(5) The technology specified by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 4 (v) of the appended table of the Foreign Exchange Order

shall be technology used to fix onto substrates substances formed by thermal decomposition of raw gas (limited to execution within the temperature range from 1,300 degrees centigrade to 2,900 degrees centigrade inclusive and the range of absolute pressure from 130 pascals to 20,000 pascals inclusive).

第十七条 外為令別表の五の項（一）の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

Article 17 (1) The technology specified by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 5 (i) of the appended table of the Foreign Exchange Order shall fall under any of the following.

一 第四条第四号から第六号までのいずれかに該当するものを設計し、又は製造するために設計したプログラム

(i) Programs designed for the design or manufacture of items that fall under any of Article 4, item (iv) through item (vi)

二 第四条第二号、第十二号ハ（一）若しくはニ又は第十五号ハ若しくはニに該当するものの設計又は製造に必要な技術（プログラムを除く。）

(ii) The technology (excluding programs) necessary for the design or manufacture of items that fall under Article 4, item (ii), item (xii), (c), 1. or (d) or item (xv), (c) or (d)

三 第四条第一号ロ若しくはハ又は第三号から第十六号までのいずれかに該当するもの（前号に該当するものを除く。）の設計又は製造に必要な技術（プログラムを除く。）

(iii) The technology (excluding programs) necessary for the design or manufacture of items that fall under any of Article 4, item (i), (b) or (c) or item (iii) through item (xvi) (excluding those falling under the preceding item)

2 外為令別表の五の項（二）の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

(2) The technology specified by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 5 (ii) of the appended table of the Foreign Exchange Order shall fall under any of the following.

一 第四条第四号から第六号までのいずれかに該当するものを使用するために設計したプログラム

(i) Programs designed to use an item that falls under any of Article 4, item (iv) through item (vi)

二 第四条第二号若しくは第十二号ハ（一）若しくはニ又は第十四条第一号に該当するものの使用（修理に係るものに限る。）に係る技術（プログラムを除く。）

(ii) The technology (excluding programs) pertaining to the use of an item that falls under Article 4, item (ii) or item (xii), (c), 1. or (d) or Article 14, item (i) (limited to those pertaining to repairs)

3 外為令別表の五の項（三）の経済産業省令で定める技術は、セラミックの材料とな

る物質又はセラミック（複合型のものを除く。）であって、次のいずれかに該当するものの設計又は製造に係る技術（プログラムを除く。）とする。

(3) The technology specified by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 5 (iii) of the appended of the Foreign Exchange Order table shall be technology (excluding programs) pertaining to the design or manufacture of ceramic materials or ceramics (excluding composites) that fall under any of the following.

一 セラミックの材料となる物質であって、次のイからハまでのすべてに該当するもの

(i) Ceramic materials that fall under all of the following (a) through (c)

イ 次のいずれかに該当するものからなるもの

(a) Ceramic materials consisting of any of the following

(一) ジルコニウムの単一又は複合酸化物及びシリコン又はアルミニウムの複合酸化物

1. Single or composite oxides of zirconium and silicon or aluminum composite oxides

(二) ほう素の単一窒化物（立方晶窒化ほう素に限る。）

2. Single nitrides of boron (limited to cubic crystalline boron)

(三) シリコン又はほう素の単一又は複合炭化物

3. Single or composite carbides of silicon or boron

(四) シリコンの単一又は複合窒化物

4. Single or composite nitrides of silicon

ロ 金属不純物の含有量の全重量に占める割合が、次の数値未満のもの

(b) Items in which the ratio of the content of metal impurities as a part of the total weight is less than following numeric values

(一) 単一酸化物又は単一炭化物にあつては、〇・一パーセント

1. 0.1% with respect to single oxides or single carbides

(二) 複合化合物又は単一窒化物にあつては、〇・五パーセント

2. 0.5% with respect to composite compounds or single nitrides

ハ 次のいずれかに該当するもの

(c) Ceramic materials that fall under any of the following

(一) 酸化ジルコニウムであつて、粒子の径の平均値が一マイクロメートル以下のものうち、径が五マイクロメートルを超える粒子の重量の合計が全重量の十パーセント以下であるもの

1. Among zirconium oxides, having particles the diameter of which is 1 micrometer or less, and wherein the total weight of particles exceeding 5 micrometers in diameter is 10% or less of total weight

(二) 粒子の径の平均値が五マイクロメートル以下であつて、径が十マイクロメートルを超える粒子の重量の合計が全重量の十パーセント以下であるもの（（一）に該当するものを除く。）

2. Those having particles the average diameter of which is 5 micrometers

or less and wherein the total particle weight of particles exceeding 10 micrometers in diameter is 10% or less of total weight (excluding those that fall under 1.)

(三) 長さ と 厚さ の 比 が 五 を 超 え る プ レ ー ト レ ッ ト、 長 さ と 直 径 の 比 が 一 〇 を 超 え、 かつ、 直 径 が 二 マ イ ク ロ メ ー ト ル 未 満 の ウ イ ス カ ー 及 び 直 径 が 一 〇 マ イ ク ロ メ ー ト ル 未 満 の 繊 維 を 有 す る も の

3. Platelets having ratio of length to thickness exceeding 5 and ratio of length to diameter exceeding 10, and having whiskers the diameter of which is less than 2 micrometers and fibers the diameter of which is less than 10 micrometers

二 前号の物質からなるセラミック（研磨材を除く。）

(ii) Ceramic made of substances in the preceding item (excluding grinding materials)

4 外為令別表の五の項（四）の経済産業省令で定める技術は、ポリベンゾチアゾール又はポリベンゾオキサゾールの設計又は製造に係る技術（プログラムを除く。）とする。

(4) The technology specified by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 5 (iv) of the appended table of the Foreign Exchange Order shall be technology (excluding programs) pertaining to the design or manufacture of polybenzothiazole or polybenzoxazole.

5 外為令別表の五の項（五）の経済産業省令で定める技術は、ビニルエーテルのモノマーを含むゴム状のふっ素化合物の設計又は製造に係る技術（プログラムを除く。）とする。

(5) The technology specified by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 5 (v) of the appended table of the Foreign Exchange Order shall be technology (excluding programs) pertaining to the design or manufacture of rubber-like fluorine compounds including vinyl ether monomers.

6 外為令別表の五の項（六）の経済産業省令で定める技術は、芳香族ポリアミド繊維の製造に係る技術（プログラムを除く。）とする。

(6) The technology specified by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 5 (vi) of the appended table of the Foreign Exchange Order shall be technology (excluding programs) pertaining to the manufacture of aromatic polyamide fiber.

7 外為令別表の五の項（七）の経済産業省令で定める技術は、有機物、金属又は炭素をマトリックスとする複合材料を設計するためのプログラムとする。

(7) The technology specified by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 5 (vii) of the appended table of the Foreign Exchange Order shall be program for the design of composite materials using organic matter, metals or carbon as a matrix.

8 外為令別表の五の項（八）の経済産業省令で定める技術は、第十四条第二号に該当する電波の吸収材又は導電性高分子の使用（据付、保守又は修理に係るものに限

る。)に係る技術(プログラムを除く。)とする。

- (8) The technology specified by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 5 (viii) of the appended table of the Foreign Exchange Order shall be technology (excluding programs) pertaining to the use of radio wave absorbers or conductive polymers that fall under Article 14, item (ii) (limited to those pertaining to installation, maintenance or repair).

第十八条 外為令別表の六の項(一)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

Article 18 (1) The technology specified by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 6 (i) of the appended table of the Foreign Exchange Order shall fall under any of the following.

一 第五条第二号ロ(三)若しくはニ、第三号、第五号若しくは次のいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)

(i) The technology (excluding programs) necessary for the design or manufacture of items that fall under Article 5, item (ii), (b), 3. or (d), item (iii), item (v) or any of the following

イ 旋削をすることができる工作機械であって、輪郭制御をすることができる軸数が二以上のもののうち、国際規格 I S O 二三〇/二(一九九七)で定める測定方法により測定したときの直線軸の位置決め精度が〇・〇〇三六ミリメートル以下のもの

(a) Among machine tools with 2 or more axes capable of controlling contours, those capable of lathe turning, and in which the precision of positioning of the rectilinear axes is 0.0036 millimeters or less when measured by the measurement method specified by International Standard ISO 230-2:1997

ロ フライス削り又は中ぐりをすることができる工作機械であって、次のいずれかに該当するもの

(b) Machine tools capable of milling or boring that fall under any of the following

(一) 輪郭制御をすることができる直線軸の数が三つで、かつ、輪郭制御をすることができる回転軸の数が一のものであって、国際規格 I S O 二三〇/二(一九九七)で定める測定方法により測定したときの直線軸の位置決め精度が〇・〇〇三六ミリメートル以下のもの

1. Machine tools with 3 rectilinear axes capable of controlling contour, and with 1 axis capable of controlling contour, and in which the precision of positioning of the rectilinear axes is 0.0036 millimeters or less when measured by the measurement method specified by International Standard ISO 230-2:1997

(二) 輪郭制御をすることができる軸数が五以上のものであって、国際規格 I S O 二三〇/二(一九九七)で定める測定方法により測定したときの直線軸の位置決め精度が〇・〇〇三六ミリメートル以下のもの

2. Machine tools with 5 or more axes capable of controlling contour, and in which the precision of positioning of the rectilinear axes is 0.0036 millimeters or less when measured by the measurement method specified by International Standard ISO 230-2:1997
- 二 前号に掲げるもののほか、第五条に該当する貨物の設計又は製造に必要な技術（プログラムを除く。）
- (ii) In addition to what is listed in the preceding item, the technology (excluding programs) necessary for the design or manufacture of the goods that fall under Article 5
- 三 第一号イ若しくはロ、第五条第二号ロ（三）若しくはニ、第三号若しくは第五号に該当するものを設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計に必要な技術（プログラムを除く。）
- (iii) Programs designed for the design or manufacture of items that fall under item (i), (a) or (b), Article 5, item (ii), (b), 3. or (d), item (iii) or item (v), or the technology (excluding programs) necessary for the design of those programs
- 四 前号に掲げるもののほか、第五条に該当する貨物を設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計に必要な技術（プログラムを除く。）
- (iv) In addition to what is listed in the preceding item, programs designed for the design or manufacture of goods that fall under Article 5, or the technology (excluding programs) necessary for the design of those programs
- 2 外為令別表の六の項（二）の経済産業省令で定める技術は、第五条に該当するものを使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計に必要な技術（プログラムを除く。）とする。
- (2) The technology specified by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 6 (ii) of the appended table of the Foreign Exchange Order shall be programs designed for the use of items that fall under Article 5 or the technology (excluding programs) necessary for the design of those programs.
- 3 外為令別表の六の項（三）の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
- (3) The technology specified by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 6 (iii) of the appended table of the Foreign Exchange Order shall fall under any of the following.
- 一 数値制御装置として機能することを可能にするプログラムであって、輪郭制御をすることができる軸数が五以上のもの又はそのプログラムの設計に必要な技術（プログラムを除く。）
- (i) Programs that enable a device to function as numerically-controlled coordinate measuring equipment with 5 or more axes capable of controlling contour or the technology (excluding programs) necessary for the design of those programs
- 二 数値制御装置の中でパートプログラムの準備又は修正を行うためのインタラクテ

- イ コンピュータグラフィックスの設計に係る技術（プログラムを除く。）
- (ii) The technology (excluding programs) pertaining to the design of interactive computer graphics to prepare or modify the part programs in numerically-controlled coordinate measuring equipment
- 三 数値制御装置に与えられた設計データを工作機械に対する命令に変換するプログラムの設計に係る技術（プログラムを除く。）
- (iii) The technology (excluding programs) pertaining to the design of the programs that convert design data given to numerically-controlled coordinate measuring equipment into commands for machine tools
- 四 意思決定を支援するエキスパートシステムを数値制御装置に組み込むためのプログラムの設計に係る技術（プログラムを除く。）
- (iv) The technology (excluding programs) pertaining to the design of programs that integrate into the numerically-controlled coordinate measuring equipment an expert system that supports decision-making
- 五 別表第三の第二欄に掲げるコーティング方法を用いるものであって、同表の第三欄に掲げる基材に対して行う同表の第四欄に掲げるコーティングに係る技術（プログラムを除く。）
- (v) The technology (excluding programs) pertaining to the coating method listed in the second column of the appended table 3 and the coatings listed in the fourth column of the same table and executed in respect to substrates listed in the third column in the same table
- 4 外為令別表の六の項（四）の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
- (4) The technology specified by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 6 (iv) of the appended table of the Foreign Exchange Order shall fall under any of the following.
- 一 超塑性成形、拡散接合又は直圧式液圧プレスによる金属の加工用の工具（型を含む。）の設計に係る技術（プログラムを除く。）
- (i) The technology (excluding programs) pertaining to the design of tools (including molds) for processing metals by super-plastic molding, diffusion bonding or direct pressure hydraulic press
- 二 金属の加工を行うためのデータであって、次のいずれかに該当するもの
- (ii) Data for processing metals that fall under any of the following
- イ アルミニウム合金、チタン合金又は超合金の超塑性成形による加工に係るものであって、加工材料の表面処理、歪率、温度又は圧力に係るもの
- (a) Data pertaining to processing by super-plastic molding of aluminum alloys, titanium alloys or super alloys, and to the surface treatment, deformation rate, temperature or pressure of processed materials
- ロ 超合金又はチタン合金の拡散接合による加工に係るものであって、加工材料の表面処理、温度又は圧力に係るもの
- (b) Data pertaining to processing by diffusion bonding of super alloys or



titanium alloys, and to the surface treatment, deformation rate, temperature or pressure of processed materials

ハ アルミニウム合金又はチタン合金の直圧式液圧プレスによる加工に係るものであって、圧力又はサイクルタイムに係るもの

(c) Data pertaining to processing of aluminum alloys or titanium alloys by direct pressure hydraulic press and to the pressure or cycle times thereof

ニ チタン合金、アルミニウム合金又は超合金の鋳造品の内部の巣を一〇二度を超える温度ですべての方向から同一の圧力を加えることにより縮小させることに係るものであって、温度、圧力又はサイクルタイムに係るもの

(d) Data pertaining to reduction of the porosity inside cast product of titanium alloy, aluminum alloy or super alloy by applying the same pressure from all directions at a temperature exceeding 102 degrees centigrade and pertaining to the temperature, pressure or cycle time thereof

5 外為令別表の六の項（五）の経済産業省令で定める技術は、航空機材の製造用の液圧式引張成形機（その型を含む。）の設計又は製造に係る技術（プログラムを除く。）とする。

(5) The technology specified by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 6 (v) of the appended table shall be technology (excluding programs) pertaining to the design or manufacture of hydraulic stretch molding devices (including the mold thereof) for manufacture of aircraft materials.

6 外為令別表の六の項（六）の経済産業省令で定める技術は、数値制御装置の附属装置であって、数値制御装置に与えられた設計データを工作機械に対する命令に変換するものの設計に係る技術（プログラムを除く。）とする。

(6) The technology specified by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 6 (vi) of the appended table of the Foreign Exchange Order shall be technology (excluding programs) pertaining to auxiliaries for numerically-controlled coordinate measuring equipment that converts the design data given to the numerically-controlled equipment into the commands for the machine tools.

第十九条 外為令別表の七の項（一）の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

Article 19 (1) The technology specified by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 7 (i) of the appended table of the Foreign Exchange Order shall fall under any of the following.

一 第六条第十六号又は第十七号イ（二）に該当するものの設計又は製造に必要な技術（プログラムを除く。）

(i) The technology (excluding programs) necessary for the design or manufacture of items that fall under Article 6, item (xvi) or item (xvii), (a), 2

二 第六条に該当するもの（同条第十六号又は第十七号イ（二）に該当するものを除く。）の設計又は製造に必要な技術（プログラムを除く。）であって、次のいずれにも該当しないもの

(ii) The technology (excluding programs) necessary for the design or manufacture of items that fall under Article 6 (excluding those falling under item (xvi) or item (xvii), (a), 2. of the same Article), and do not fall under any of the following

イ 同条第十六号の二に該当するものの製造に必要な技術

(a) The technology necessary for manufacturing items that fall under item (xvi)-2 of the same Article

ロ 同条第一号ハからルまでのいずれかに該当する集積回路のうち、次の（一）及び（二）に該当するものの設計又は製造に必要な技術

(b) Among technologies that fall under any of item (i), (c) through (k) of the same Article, the technology necessary for the design or manufacture of integrated circuits that fall under the following 1. and 2.

（一） 最小線幅が〇・五マイクロメートル以上のもの

1. Integrated circuits whose minimum line width which is 0.5 micrometers or more

（二） 多層構造（多結晶シリコン層及び金属層がいずれも三層以下のものを除く。）を有しないもの

2. Integrated circuits that do not possess multilayered structure (excluding those in which both the number of polycrystalline silicon layers and the number of metal layers are three or less)

三 第六条第十六号又は第十七号イ（二）に該当するものを設計し、又は製造するために設計したプログラム

(iii) Programs designed for the design or manufacture of circuits that fall under Article 6, item (xvi) or item (xvii), (a), 2.

四 第六条第十六号の二に該当するものを設計するために設計したプログラム

(iv) Programs designed for the design of integrated circuits that fall under Article 6, item (xvi)-2

五 第六条に該当するもの（前二号又は同条第一号若しくは第十八号から第二十一号までのいずれかに該当するものを除く。）を設計し、又は製造するために設計したプログラム

(v) Programs designed for the design or manufacture of integrated circuits that fall under Article 6 (excluding those that fall under any of the preceding two items or item (i) or item (xvii) through item (xxi) of the same Article)

2 外為令別表の七の項（二）の経済産業省令で定める技術は、第六条第十七号イからへまでのいずれか又はチに該当するものを使用するために設計したプログラムとする。

(2) The technology specified by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 7 (ii) of the appended table of the Foreign Exchange Order shall be programs designed for the use of items that fall under any of Article 6,

item (xvii), (a) through (f) or (h).

3 外為令別表の七の項（三）の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

(3) The technology specified by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 7 (iii) of the appended table of the Foreign Exchange Order shall fall under any of the following.

一 導体、絶縁体又は半導体に対してマスクパターンを転写させるためのリソグラフィ工程、エッチング工程又は成膜工程を条件設定するための物理的シミュレーションプログラム

(i) Physical simulation programs for establishing the conditions of the lithography process, etching process or film forming process to transfer mask patterns to conductors, insulators or semiconductors

二 絶縁体が二酸化けい素からなる集積回路の基板であって、シリコンオンインシュレータ構造を有するものの設計又は製造に係る技術（プログラムを除く。）

(ii) The technology (excluding programs) pertaining to the design or manufacture of substrates of integrated circuits whose insulators are made of silicon dioxide and that have silicon-on-insulator structure.

三 マイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ又はマイクロコントローラであって、論理演算ユニットのアクセス幅のビット数が三十二以上のもののうち、複合理論性能（別表第一の中欄に掲げるものの種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。）が一秒につき五三〇メガ演算以上のものの設計又は製造に必要な技術（プログラムを除く。）。ただし、第六条第一号ハからルまでのいずれかに該当する集積回路のうち、次のイ及びロに該当するものの設計又は製造に必要な技術を除く。

(iii) The technology (excluding programs) necessary for the design or manufacture of, among microprocessors, microcomputers, or microcontrollers, wherein the bit count of the access width of logic-operations is 32 or more, those having a composite theoretical performance of 530 Mtops per second or more (depending on the types listed in the middle column in the appended table 1, the performance of each shall be listed in the right column of the same table). However, among integrated circuits that fall under any of Article 6, item (i), (c) through (k), the technology necessary for the design or manufacture of those that fall under the following (a) and (b) shall be excluded.

イ 最小線幅が〇・五マイクロメートル以上のもの

(a) Microprocessors, microcomputers, or microcontrollers with whose minimum line width 0.5 micrometers or more

ロ 多層構造（多結晶シリコン層及び金属層がいずれも三層以下のものを除く。）を有しないもの

(b) Microprocessors, microcomputers, or microcontrollers that do not possess multilayered structures (excluding those in which both the number of

- polycrystalline silicon layers and the number of metal layers are 3 or less)
- 4 外為令別表の七の項（四）の経済産業省令で定める技術は、超電導材料を用いた電子素子の設計又は製造に係る技術（プログラムを除く。）とする。
- (4) The technology specified by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 7 (iv) of the appended table of the Foreign Exchange Order shall be technology (excluding programs) pertaining to the design or manufacture of electronic elements using superconductive materials.
- 5 外為令別表の七の項（五）の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
- (5) The technology specified by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 7 (v) of the appended table of the Foreign Exchange Order shall fall under any of the following.
- 一 導体、絶縁体又は半導体に対してマスクパターンを転写させるためのリソグラフィ工程、エッチング工程又は成膜工程を条件設定するための物理的シミュレーションプログラム
- (i) Physical simulation programs for establishing the conditions of the lithography processes, etching process or film forming process to transfer mask patterns to conductors, insulators and semiconductors
- 二 真空マイクロエレクトロニクス装置の設計又は製造に係る技術（プログラムを除く。）
- (ii) The technology (excluding programs) pertaining to the design or manufacture of vacuum microelectronics devices
- 三 ヘテロ接合の半導体素子（動作周波数が三一・八ギガヘルツ未満の高電子移動度トランジスタ又はヘテロ接合バイポーラトランジスタを除く。）の設計又は製造に係る技術（プログラムを除く。）
- (iii) The technology (excluding programs) pertaining to the design or manufacture of hetero-junction microchips (excluding high electron mobility transistors or hetero-junction bipolar transistors whose operating frequency is less than 31.8 gigahertz)
- 四 電子機器の部分品として用いる基板であって、ダイヤモンドからなる薄膜又は炭化けい素を用いたものの設計又は製造に係る技術（プログラムを除く。）
- (iv) The technology (excluding programs) pertaining to the design or manufacture of substrates used as components of electronic devices that use thin films made of diamond or silicon carbide
- 五 動作周波数が三一・八ギガヘルツ以上の電子管の設計又は製造に係る技術（プログラムを除く。）
- (v) The technology (excluding programs) pertaining to the design or manufacture of electron tubes whose operating frequency is 31.8 gigahertz or more

第二十条 外為令別表の八の項（一）の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに

該当するものとする。

**Article 20 (1) The technology specified by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 8 (i) of the appended table of the Foreign Exchange Order shall fall under any of the following.**

一 第七条第一号ロ又は同条第三号ハに該当するものの設計又は製造に必要な技術（プログラムを除く。）

**(i) The technology (excluding programs) necessary for the design or manufacture of items falling under Article 7, item (i), (b) or item (iii), (c) of the same Article**

二 前号に掲げるもののほか、第七条各号に該当する貨物の設計又は製造に必要な技術（プログラムを除く。）

**(ii) In addition to what is listed in the preceding item, technology (excluding programs) necessary for the design or manufacture of goods that fall under the items of Article 7**

三 第七条第一号ロ若しくは同条第三号ハに該当するものを設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計若しくは製造に必要な技術（プログラムを除く。）

**(iii) Programs designed for the design or manufacture of items falling under Article 7, item (i), (b) or item (iii), (c) of the same Article or technology (excluding programs) necessary for the design or manufacture of those programs**

四 前号のプログラムの使用に必要な技術（プログラムを除く。）

**(iv) The technology (excluding programs) necessary for the use of the programs in the preceding item**

五 第三号に掲げるもののほか、第七条各号に該当する貨物を設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に必要な技術（プログラムを除く。）

**(v) In addition to what is listed in item (iii), programs designed for the design or manufacture of goods that fall under the items of Article 7, or technology (excluding programs) necessary for the design, manufacture, or use of those programs**

六 第七条に該当するものの使用に必要な技術（プログラムを除く。）

**(vi) The technology (excluding programs) necessary for the use of items falling under Article 7**

七 第七条に該当するものを使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に必要な技術（プログラムを除く。）

**(vii) Programs designed for the use of items that fall under Article 7 or technology (excluding programs) necessary for the design, manufacture or use of those programs**

八 第一号から前号までに該当する技術（プログラムを除く。）を支援するために設計したプログラム

(viii) Programs designed to support technology (excluding programs) that falls under any items from item (i) through the preceding item

2 外為令別表の八の項(二)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

(2) The technology specified by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 8 (ii) of the appended table of the Foreign Exchange Order shall fall under any of the following.

一 次のいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)

(i) The technology (excluding programs) necessary for the design or manufacture of items that fall under any of the following

イ 加重最高性能が0.04実効テラ演算超0.1実効テラ演算以下のデジタル電子計算機

(a) Digital computers Adjusted Peak Performance exceeds 0.04 Weighted TeraFLOPS and is 0.1 Weighted TeraFLOPS or less

ロ 加重最高性能が0.1実効テラ演算超0.75実効テラ演算以下のデジタル電子計算機

(b) Digital computers whose Adjusted Peak Performance exceeds 0.1 Weighted TeraFLOPS and is 0.75 Weighted TeraFLOPS or less

二 デジタル電子計算機の機能を向上するように設計した部分品であって、計算要素を集合させることにより、加重最高性能が0.04実効テラ演算超0.75実効テラ演算以下になるものに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)

(ii) The technology (excluding programs) necessary for the design or manufacture of components designed to improve the functions digital computers, which components, by aggregating calculation elements achieve Adjusted Peak Performance that exceeds 0.04 Weighted TeraFLOPS and is 0.75 Weighted TeraFLOPS or less

三 次のいずれかに該当するものを設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計若しくは製造に必要な技術(プログラムを除く。)

(iii) The technology (excluding programs) necessary for programs designed for the design or manufacture of items that fall under any of the following or the design or manufacture of those programs

イ 加重最高性能が0.04実効テラ演算超0.1実効テラ演算以下のデジタル電子計算機

(a) Digital computers whose Adjusted Peak Performance exceeds 0.04 Weighted TeraFLOPS and is 0.1 Weighted TeraFLOPS or less

ロ 加重最高性能が0.1実効テラ演算超0.75実効テラ演算以下のデジタル電子計算機

(b) Digital computers whose Adjusted Peak Performance exceeds 0.1 Weighted TeraFLOPS and is 0.75 Weighted TeraFLOPS or less

- 四 前号のプログラムの使用に必要な技術（プログラムを除く。）
- (iv) The technology (excluding programs) necessary for the use of the programs in the preceding item
- 五 デジタル電子計算機の機能を向上するように設計した部分品であって、計算要素を集合させることにより、加重最高性能が〇・〇四実効テラ演算超〇・七五実効テラ演算以下になるものを設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に必要な技術（プログラムを除く。）
- (v) Programs designed for the design or manufacture of components designed to improve the functions of digital computers which components, by aggregating calculation elements, achieve Adjusted Peak Performance that exceeds 0.04 Weighted TeraFLOPS and is 0.75 Weighted TeraFLOPS or less or the technology (excluding programs) necessary for the design, manufacture or use of those programs
- 六 第一号から前号までに該当する技術（プログラムを除く。）を支援するために設計したプログラム
- (vi) Programs designed to support technologies (excluding programs) that fall under item (i) through the preceding item
- 七 プログラムであって、次のいずれかに該当するもの又はその設計、製造若しくは使用に必要な技術（プログラムを除く。）
- (vii) Programs that fall under any of the following or the technology (excluding programs) necessary for the design, manufacture or use of those programs
- イ 並列処理機能を有する装置のために設計されたオペレーティングシステム、プログラム開発ツール又はコンパイラであって、ソースコードのもの
- (a) Operating systems, programming development tools, or compilers that are designed for devices having parallel processing functions and are source code
- ロ 削除
- (b) Deleted
- 八 前号の技術（プログラムを除く。）を支援するために設計したプログラム
- (viii) Programs designed to support the technology (excluding programs) in the preceding item
- 九 第八条第九号、第十号、第十二号又は第十三号のいずれかに該当する貨物の有する機能と同等の機能を有するプログラム又は当該機能のシミュレーションを行うことができるプログラム
- (ix) Programs having equivalent functions to goods that fall under any of Article 8, item (ix), item (x), item (xii) or item (xiii) or programs that are capable of simulating the said functions
- 十 前号のプログラムを検定するためのプログラム
- (x) Programs to verify programs in the preceding item
- 十一 前二号のいずれかに該当するものの設計、製造又は使用のために設計したプログラム

(xi) Programs designed for the design, manufacture or use of those falling under any of preceding two items

十二 前三号のいずれかに該当するものの設計、製造若しくは使用に必要な技術（プログラムを除く。）又はこれを支援するために設計したプログラム

(xii) The technology (excluding programs) necessary for the design, manufacture or use of items falling under any of preceding three items or programs designed to support them

第二十一条 外為令別表の九の項（一）の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

Article 21 (1) The technology specified by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 9 (i) of the appended table of the Foreign Exchange Order shall fall under any of the following.

一 第八条第二号イ（二）又は第六号に該当するものの設計又は製造に必要な技術（プログラムを除く。）

(i) The technology (excluding programs) necessary for the design or manufacture of items that fall under Article 8, item (ii), (a), 2. or item (vi)

二 第八条第一号、第二号、第四号から第七号まで、第八号の二、第九号、第十号、第十二号又は第十三号のいずれかに該当するもの（前号に該当するものを除く。）の設計又は製造に必要な技術（プログラムを除く。）

(ii) The technology (excluding programs) necessary for the design or manufacture of items that fall under any of Article 8, item (i), item (ii), item (iv) through item (vii), item (viii)-2, item (ix), item (x), item (xii) or item (xiii) (excluding those falling under the preceding item)

三 第八条第九号、第十号、第十二号又は第十三号のいずれかに該当するものの使用に必要な技術（プログラムを除く。）

(iii) The technology (excluding programs) necessary for the use of items that fall under any of Article 8, item (ix), item (x), item (xii) or item (xiii)

四 第八条第一号、第二号、第四号から第七号まで又は第八号の二のいずれかに該当するものの使用（操作に係るものを除く。）に必要な技術（プログラムを除く。）

(iv) The technology (excluding programs) necessary for the use (excluding those pertaining to operations) of items that fall under any of Article 8, item (i), item (ii), item (iv) through item (vii) or item (viii)-2

五 第八条第二号イ（二）又は第六号に該当するものを設計し、又は製造するために設計したプログラム

(v) Programs designed for the design or manufacture of items that fall under Article 8, item (ii), (a), 2.

六 第八条第一号、第二号、第四号から第七号まで又は第八号の二のいずれかに該当するもの（前号に該当するものを除く。）を設計し、又は製造するために設計したプログラム

(vi) Programs designed for the design or manufacture of items that fall under



- (excluding those falling under the preceding item) any of Article 8, item (i), item (ii), item (iv) through item (vii), or item (viii)-2
- 七 第八条第九号、第十号、第十二号又は第十三号のいずれかに該当するものを設計し、又は製造するために設計したプログラム
- (vii) Programs designed for the design or manufacture of items that fall under Article 8, item (ix), item (x), item (xii) or item (xiii)
- 八 第八条第一号、第二号、第四号から第七号まで又は第八号の二のいずれかに該当するものを使用するために設計したプログラム
- (viii) Programs designed for the use of items that fall under any of Article 8, item (i), item (ii), and item (iv) through item (vii) or item (viii)-2
- 八の二 第八条第九号、第十号、第十二号又は第十三号のいずれかに該当するものを使用するために設計したプログラム
- (viii)-2 Programs designed for the use of items that fall under any of Article 8, item (ix), item (x), item (xii) or item (xiii)
- 九 第八条第九号、第十号、第十二号又は第十三号のいずれかに該当する貨物の機能を実現するためのプログラム又は当該機能のシミュレーションを行うことができるプログラム
- (ix) Programs to realize the functions of goods that fall under any of Article 8, item (ix), item (x), item (xii) or item (xiii) or programs that are capable of simulating the said functions
- 十 前号に該当するものを検定するためのプログラム
- (x) Programs used for verification of items that fall under the preceding item
- 十一 第五号のプログラムの設計又は製造に必要な技術（プログラムを除く。）
- (xi) The technology (excluding programs) necessary for the design or manufacture of the programs in item (v)
- 十一の二 第五号のプログラムの使用（操作に係るものを除く。）に必要な技術（プログラムを除く。）
- (xi)-2 The technology (excluding programs) necessary for the use of the program in item (v) (excluding those pertaining to operations)
- 十二 第七号、第八号の二、第九号又は第十号のプログラムの設計又は製造に必要な技術（プログラムを除く。）
- (xii) The technology (excluding programs) necessary for the design or manufacture of the programs in item (vii), item (viii)-2, item (ix) or item (x)
- 十二の二 第七号、第八号の二、第九号又は第十号のプログラムの使用に必要な技術（プログラムを除く。）
- (xii)-2 The technology (excluding programs) necessary for the use of programs in item (vii), item (viii)-2, item (ix) or item (x)
- 十三 第六号又は第八号のプログラムの設計、製造又は使用（操作に係るものを除く。）に必要な技術（プログラムを除く。）
- (xiii) The technology (excluding programs) necessary for the design, manufacture or use (excluding those that pertains to operations) of the

programs in item (vi) or item (viii)

十四 第一号又は第十一号の技術を支援するために設計したプログラム

(xiv) Programs designed to support the technology in item (i) or item (xi)

十五 第二号から第四号まで又は第十一号の二から第十三号までの技術を支援するために設計したプログラム

(xv) Programs designed to support the technology from item (ii) through item (iv) or item (xi)-2 through item (xiii)

2 外為令別表の九の項（二）の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

(2) The technology specified by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 9 (ii) of the appended table of the Foreign Exchange Order shall fall under any of the following.

一 削除

(i) Deleted

二 第八条第一号、第二号、第四号から第七号まで又は第八号の二のいずれかに該当する貨物の有する機能と同等の機能を提供するために設計したプログラム

(ii) Programs designed to provide the functions equivalent to those of goods that fall under any of Article 8, item (i), item (ii), item (iv) through item (vii) or item (viii)-2.

三 経路選択方式がダイナミックルーティング方式の装置を設計、製造又は使用するために設計したプログラム（機械語で表したものを除く。）

(iii) Programs designed for the design, manufacture or use of equipment the routing selection method of which is a dynamic routing method (excluding those expressed in machine language)

三の二 伝送通信装置又は電子式交換装置であって、イ、ロ（一）若しくは（五）、ハ若しくはニ（一）に該当するものを設計するためのプログラム又は次のいずれかに該当するものの設計若しくは製造に必要な技術（プログラムを除く。）

(iii)-2 Programs for the design of transmission communication devices or electronic interchanging devices that fall under (a); (b), 1. or 5.; (c) or (d), 1., or the technology (excluding programs) necessary for the design or manufacture of those falling under any of the following

イ デジタル伝送方式を用いたものであって、一五ギガビット毎秒を超える総合伝送速度（最高位多重化レベルにおける単位時間当たりの信号ビット（情報ビット並びにラインコーディング及びオーバーヘッドその他の付加ビットを含む。）数をいう。）で使用することができるように設計したもの

(a) Those that use a digital transmission scheme and are designed to be capable of using at total transmission rate that exceeds 15 gigabits per second (referring to signals bits per unit time at maximum multiplexing level (including information bits and added bits, such as for line coding and overhead))

ロ レーザー発振器を用いたものであって、次のいずれかに該当するもの

- (b) Those that use laser oscillators and that fall under any of the following
- (一) 一、七五〇ナノメートルを超える波長のレーザー光を利用するもの
    1. Those that utilize laser beams whose wave length exceeds 1,750 nanometers
      - (二) レーザー光を増幅する機能を有するものであって、プラセオジウムを添加したふっ化物の光ファイバーを用いたもの
    2. Those that have the function of amplifying laser beams and that use optical fibers of praseodymium-doped fluorides
      - (三) コヒーレント伝送方式を用いたもの
    3. Those that use a coherent transmission method
      - (四) 光波長多重化技術を用いたものであって、一ウィンドウ当たりの光搬送波の数が八を超えるもの
    4. Those that use light wavelength multiplex technology and wherein whose number of optical carrier waves per window exceeds 8
      - (五) アナログ伝送方式を用いたものであって、帯域幅が二・五ギガヘルツを超えるもの（テレビジョン放送（有線テレビジョン放送を含む。）用の装置を除く。）
    5. Those that use an analog transmission method whose bandwidth exceeds 2.5 gigahertz (excluding devices for TV broadcasting (including cable TV broadcasting))
  - ハ 光交換機能を有するもの
- (c) Those having an optical switching function
- ニ 無線送信機又は無線受信機であって、次のいずれかに該当するもの
- (d) Wireless transmitters or wireless receivers that fall under any of the following
- (一) 二五六値を超える直交振幅変調技術を用いたもの
    1. Wireless transmitters or receivers that use quadrature amplitude modulation technology that exceeds the value of 256
      - (二) 三一・八ギガヘルツを超える周波数で使用することができるもの（国際電気通信連合が無線通信用に割り当てた周波数帯域（無線測位用に割り当てた周波数帯域を除く。）で使用するように設計したものを除く。）
    2. Those that can be used at frequencies that exceed 31.8 gigahertz (excluding frequency bands allocated for wireless communication by the International Telecommunication Union (excluding the frequency bands allocated for radio determinations))
  - ホ 非対応網で動作する共通線信号機能を有するもの
- (e) Those having common channel signaling functions that operate in non compliant networks
- 四 前三号のいずれかに該当するプログラムの設計、製造又は使用（操作に係るものを除く。）に必要な技術（プログラムを除く。）
- (iv) The technology (excluding programs) necessary for the design, manufacture

- or use (excluding those pertaining to operations) of programs that fall under any of the preceding three items
- 五 人工衛星に搭載することができるように設計した伝送通信装置の設計又は製造に必要な技術（プログラムを除く。）
- (v) The technology (excluding programs) necessary for the design or manufacture of transmission communication devices designed to be mounted on satellites
- 六 レーザーを用いた通信技術であって、信号を自動的に受信及び追跡し、かつ、大気圏外又は水中との通信を行うことができるものの設計又は使用に係る技術（プログラムを除く。）
- (vi) Technology (excluding programs) pertaining to the design or use of communication technology that uses lasers and receives or tracks signals automatically and is also capable of communicating outside the atmosphere or under water
- 七 削除
- (vii) Deleted
- 八 削除
- (viii) Deleted
- 九 削除
- (ix) Deleted
- 十 削除
- (x) Deleted
- 十一 プログラムの交換により、マルチバンド、マルチチャンネル、マルチモード、マルチコーディングアルゴリズム又はマルチプロトコルの動作が可能となるように、その信号受信機能を変更可能なデジタル方式のセルラー無線通信に用いる無線基地局受信装置の設計に係る技術（プログラムを除く。）
- (xi) The technology (excluding programs) pertaining to the design of the wireless base station receiver used for digital cellular wireless communication and signal reception functions of which is capable of modifying in order to enable multiband, multiple channels, multimode, multi-coding algorithms or multiprotocol operation by switching programs
- 十二 削除
- (xii) Deleted
- 十三 削除
- (xiii) Deleted
- 十四 スペクトル拡散（周波数ホッピングを含む。）技術を用いた伝送通信装置の設計に係る技術（プログラムを除く。）
- (xiv) The technology (excluding programs) pertaining to the design of transmission communication devices using the spectrum diffusion technology (including frequency hopping)
- 十五 第三号の二、第四号から第六号まで、第十一号又は前号のいずれかに該当する

技術（プログラムを除く。）を支援するために設計したプログラム  
(xv) Programs designed to support technology (excluding programs) that falls under any of item (iii)-2, item (iv) through item (vi), item (xi) or the preceding item

第二十二条 外為令別表の一〇の項（一）の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

Article 22 (1) The technology specified by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 10 (i) of the appended table of the Foreign Exchange Order shall fall under any of the following.

一 第九条に該当するものの設計に必要な技術（プログラムを除く。）

(i) The technology (excluding programs) necessary for the design of items that fall under Article 9

二 第九条第一号イ（二）若しくはロ（三）、第三号イ、ロ、ホ若しくはへ、第四号、第五号イ、第八号イ、第九号ハ若しくはニ、第十一号ロ又は第十三号ニ、チ若しくはルに該当するものの製造に必要な技術（プログラムを除く。）

(ii) The technology (excluding programs) necessary for the manufacture of items that fall under Article 9, item (i), (a), 1. or (b), 3., item (iii), (a), (b) or (e) or (f), item (iv), item (v), (a), item (viii), (a), item (ix), (c) or (d), item (xi), (b) or item (xiii), (d), (h) or (k)

三 第九条に該当するもの（前号に該当するものを除く。）の製造に必要な技術（プログラムを除く。）

(iii) The technology (excluding programs) necessary for manufacture of items that fall under Article 9 (excluding those falling under the preceding item)

四 第九条第九号ハ若しくはニ又は第十三号ニ、チ若しくはルに該当するものを設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計に必要な技術（プログラムを除く。）

(iv) Programs designed for the design or manufacture of items that fall under Article 9, item (ix), (c) or (d) or item (xiii), (d), (h) or (k) or technology (excluding programs) necessary for the design of those programs

五 第九条第九号から第十号まで又は第十三号に該当するもの（前号に該当するものを除く。）を設計し、又は製造するために設計したプログラム

(v) Programs designed for the design or manufacture of items that fall under Article 9, item (ix) through item (x) or item (xiii) (excluding those falling under the preceding item)

六 前号のプログラムの設計に必要な技術（プログラムを除く。）

(vi) The technology (excluding programs) necessary for the design of the programs of the preceding item

2 外為令別表の一〇の項（二）の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

(2) The technology specified by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade

and Industry in row 10 (ii) of the appended table of the Foreign Exchange Order shall fall under any of the following.

一 第九条第四号若しくは第十三号又は第十四条第八号ロに該当するものを使用するために設計したプログラム

(i) Programs designed for the use of items that fall under Article 9, item (iv) or Article 13 or Article 14, item (viii), (b).

二 前号のプログラムの設計に必要な技術（プログラムを除く。）

(ii) The technology (excluding programs) necessary for the design of the programs in the preceding item

三 プログラムであって、次のいずれかに該当するもの

(iii) Programs that fall under any of the following

イ 磁力計又は磁場勾配計の校正装置であって、車両、船舶、航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体に搭載するように設計したもののために設計したプログラム

(a) Programs for magnetometer or magnetic field gradiometer calibrating equipment and designed to be mounted on vehicles, vessels, aircraft or satellites or other spacecrafts for space development

ロ 車両、船舶、航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体上で磁気異常を検出するために設計したプログラム

(b) Programs designed to detect magnetic abnormalities on vehicles, vessels, aircraft, satellites or other spacecrafts for space development

ハ 重力計又は重力勾配計に対する運動の影響を補正するために設計したプログラム

(c) Programs designed to compensate for the impact of movement on gravimeters or gravity gradiometer

ニ 航空管制用のプログラムであって、次のいずれかに該当するもの

(d) Air traffic control programs that fall under any of the following.

(一) 一五〇以上のシステムトラックを同時に処理及び表示することができるもの

1. Air traffic control programs capable of processing and displaying 150 or more system tracks at the same time

(二) 五以上の一次レーダーから目標データを受信することができるもの

2. Air traffic control programs capable of receiving target data from 5 or more primary radars

四 前号のプログラムの設計に必要な技術（プログラムを除く。）

(iv) The technology (excluding programs) necessary for the design of the programs in the preceding item

3 外為令別表の一〇の項（三）の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

(3) The technology specified by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 10 (iii) of the appended table of the Foreign Exchange

Order shall fall under any of the following.

一 光学的被膜であって、直径又は長軸の長さが五〇〇ミリメートル以上で、かつ、吸収及び散乱による損失が〇・〇〇五未満のものうち、均一度が九九・五パーセント以上のものの製造に必要な技術（プログラムを除く。）

(i) Technology (excluding programs) necessary for the manufacture, among optical coatings, the diameter or long axis length of which is 500 millimeters or more and the loss due to absorption and scatter of which is less than 0.005, those having uniformity of 99.5% or more

二 シングルポイントダイヤモンド工具を用いた旋削に係る技術（プログラムを除く。）であって、面積が〇・五平方メートルを超える曲面を、面精度の二乗平均が一〇ナノメートル未満となるように仕上げるためのもの

(ii) Technology (excluding programs) pertaining to lathe turning using single point diamond tools and for finishing such that the root-mean-square of surface precision for curved surface areas exceeding 0.5 square meters is less than 10 nanometers

4 外為令別表の一〇の項（四）の経済産業省令で定める技術は、超高出力レーザー発振器の試験装置の設計、製造又は使用に必要な技術（プログラムを除く。）とする。

(4) The technology specified by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 10 (iv) of the appended table Foreign Exchange Order shall be technology (excluding programs) necessary for the design, manufacture or use of test equipment for extra high output laser oscillators.

5 外為令別表の一〇の項（六）の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

(5) The technology specified by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 10 (vi) of the appended table of the Foreign Exchange Order shall fall under any of the following.

一 次のイ及びロに該当するレードームを製造するためのプログラム

(i) Programs for manufacturing radomes that fall under following (a) and (b)

イ 電子的に走査が可能なフェーズドアレーアンテナを保護するために設計したものの

(a) Radomes designed to protect phased array antennas that are capable of scanning electronically

ロ 平均サイドローブに対するメインビームのピーク値の出力比が四〇デシベルを超えるアンテナパターンを生じるもの

(b) Radomes that produce antenna patterns with the output ratio of main beam peak value to average side lobes exceeding 40 decibels

二 前号のプログラムの設計に必要な技術（プログラムを除く。）

(ii) The technology (excluding programs) necessary for the design of the programs of the preceding item

6 外為令別表の一〇の項（七）の経済産業省令で定める技術は、超高出力レーザー発振器が出力したレーザー光に対する物質の耐久性の試験を行うための装置又はその試

験に用いる標的の設計、製造又は使用に必要な技術（プログラムを除く。）とする。

- (6) The technology specified by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 10 (vii) of the appended table of the Foreign Exchange Order shall be technology necessary for the design, manufacture or use of devices to perform tests of the durability of substances against laser beams output by extra-high-output laser oscillators or the targets used for the test.

第二十三条 外為令別表の一の項（一）の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

Article 23 (1) The technology specified by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 11 (i) of the appended table of the Foreign Exchange Order shall fall under any of the following.

一 第十条に該当するものの設計又は製造に必要な技術（プログラムを除く。）

(i) The technology (excluding programs) necessary for the design or manufacture of items that fall under Article 10

二 第十条に該当するものを設計し、又は製造するために設計したプログラム

(ii) Programs designed for the design or manufacture of items that fall under Article 10

三 前号のプログラムの設計に必要な技術（プログラムを除く。）

(iii) The technology (excluding programs) necessary for the design of the programs in the preceding item

2 外為令別表の一の項（二）の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

(2) The technology specified by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 11 (ii) of the appended table of the Foreign Exchange Order shall fall under any of the following.

一 姿勢方位基準装置（ジンバル方式のものを除く。）、慣性航法装置その他の慣性装置を使用するためのプログラム（ソースコードのものに限る。）又はそのプログラムの設計に必要な技術（プログラムを除く。）

(i) Programs for using an attitude direction reference system (excluding those using the gimbal method), inertial navigation systems, and other inertial systems (limited to those with source code) or technology (excluding programs) necessary for the design of those programs

二 第十条の第一号から第三号の二までのいずれか又は第四号に該当するものの使用（修理又はオーバーホールに係るものに限る。）に必要な技術（プログラムを除く。）

(ii) Technology (excluding programs) necessary for the use of items that fall under any of Article 10, item (i) through item (iii)-2 or item (iv) (limited to those pertaining to repairs or overhauls)

3 外為令別表の一の項（三）の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。



- (3) The technology specified by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 11 (iii) of the appended table of the Foreign Exchange Order shall fall under any of the following.
- 一 第十条第一号又は第二号に該当するものを内蔵した慣性航法装置又はジャイロ天測航法装置の設計又は製造に係る技術（プログラムを除く。）
    - (i) The technology (excluding programs) pertaining to the design or manufacture of inertial navigation systems or gyro-astro compasses for celestial navigation that incorporate items that fall under Article 10, item (i) or item (ii)
    - 二 第二十七条第三項各号又は第四項に該当するプログラムの設計に係る技術（プログラムを除く。）
      - (ii) The technology (excluding programs) pertaining to the design of the programs that fall under each item of Article 27, paragraph (3) or paragraph (4)
  - 4 外為令別表の一一の項（四）の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
    - (4) The technology specified by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 11 (iv) of the appended table of the Foreign Exchange Order shall fall under any of the following.
      - 一 センサーデータを統合し、エキスパートシステムを用いたアビオニクス装置の使用のためのプログラム（ソースコードのものに限る。）又はそのプログラムの設計に必要な技術（プログラムを除く。）
        - (i) Programs for the use of avionics equipment that integrates sensor data and uses an expert system (limited to those with source code) or technology (excluding programs) necessary for the design of those programs
        - 二 次のいずれかに該当するものの設計のためのプログラム（ソースコードのものに限る。）
          - (ii) Programs for the design of items that fall under any of the following (limited to those with source code)
            - イ 飛行経路を最適化するためのデジタル飛行管理装置
              - (a) Digital air traffic controllers for optimizing air flight routes
            - ロ 推進制御と飛行制御を統合するための装置
              - (b) Equipment to integrate propulsion control and flight control
            - ハ フライバイワイヤ方式又はフライバイライト方式の操縦装置
              - (c) Operation equipment using fly-by-wire method or fly-by-light method
            - ニ 故障許容機能又は自己再構成機能をもつアクティブ飛行制御装置
              - (d) Active flight controllers having a fault tolerance function or a self-reconfiguring function
            - ホ 航空機局用の自動方向探知装置
              - (e) Automatic direction detectors for aircraft stations
            - ヘ 機体表面の静的データを基準とするエアーデータ装置

- (f) Air data equipment that uses the static data of airframe surface as a reference  
 ト ラスター型ヘッドアップディスプレイ又は三次元ディスプレイ
- (g) Raster type head-up displays or three-dimensional displays  
 三 前号のプログラムの設計に必要な技術（プログラムを除く。）
- (iii) The technology (excluding programs) necessary for the design of the programs of the preceding item  
 四 次のいずれかに該当するものの設計又は製造に係る技術（プログラムを除く。）
- (iv) The technology (excluding programs) pertaining to the design or manufacture of items that fall under any of the following  
 イ 航空機局用の自動方向探知装置であって、五メガヘルツを超える周波数で使用するができるように設計したもの
- (a) Automatic direction detectors for aircraft stations designed for the use with frequencies exceeding 5 megahertz  
 ロ 機体表面の静的データを基準とするエアデータ装置
- (b) Air data equipment that uses static data on the airframe surface as a reference  
 ハ 航空機用のラスター型ヘッドアップディスプレイ又は三次元ディスプレイ
- (c) Raster type head-up display or three-dimensional display for aircraft  
 ニ 飛行制御のために設計した電気アクチュエーター
- (d) Electric actuators designed for flight control  
 ホ アクティブ飛行制御を行うために設計した飛行制御用光センサーアレー
- (e) Flight control optical sensor array designed for conducting active flight control
- 五 アクティブ飛行制御装置の設計に係る技術であって、次のいずれかに該当するもの
- (v) The technology pertaining to the design of active flight controllers that falls under any of the following  
 イ 制御則を実時間で実行するために、機体に搭載した複数のコンピュータを統合する技術（プログラムを除く。）
- (a) The technology (excluding programs) that integrates multiple computers mounted on an airframe, in order to execute the control rules in real time  
 ロ センサーの相対位置又は機体の動的荷重の変動に伴い制御則を補償する技術（プログラムを除く。）
- (b) The technology (excluding programs) that compensates for the control rule according to fluctuations in the relative position of sensors or the dynamic load of the airframe  
 ハ 故障の検出若しくは許容、故障箇所の分離又は再構成のために装置又はデータの冗長性をコンピュータにより管理する技術（プログラムを除く。）
- (c) The technology (excluding programs) that controls equipments or data redundancy by computers for detection or tolerance of failures, separation

or reconfiguring of fault locations

ニ 力及びモーメントの制御の再構成を飛行中に行うことにより実時間における自律的な飛行制御を行う技術（プログラムを除く。）

(d) Technology (excluding programs) that autonomously performs flight control in real time by reconfiguring force and moment control in flight

ホ 飛行経路を最適化するためデジタル飛行管理装置にデジタル飛行制御、航法及び推進制御のデータを統合する技術（プログラム及び超短波全方位式無線標識、距離測定装置、計器着陸装置又はマイクロ波着陸装置のみを統合した飛行計器装置のための技術は除く。）

(e) Technology that integrates the data of digital flight control, navigation, and propulsion control into a digital flight traffic controller in order to optimize flight routes (excluding technology for flight instrument devices that integrate only programs and very high frequency omnidirectional range, distance measurement devices, instrument landing devices or microwave landing devices.)

ヘ フルオーソリティーデジタル飛行制御（フルオーソリティーデジタルエンジン制御に係る技術を除く。）又はマルチセンサーミッション管理のための装置であって、エキスパートシステムを用いたものに係る技術（プログラムを除く。）

(f) Technology (excluding programs) pertaining to full authority digital flight control (excluding technology pertaining to full authority digital engine control) or equipment for multi-sensor mission control that uses an expert system

ト イからへまでのいずれかに該当する技術を用いたアクティブ飛行制御装置のために設計したCADプログラム

(g) CAD programs designed for an active flight controller that uses technology that falls under any of (a) through (f)

チ トのプログラムの設計に必要な技術（プログラムを除く。）

(h) Technology (excluding programs) necessary for the design of the program in (g)

六 ヘリコプター用の装置であって、次のいずれかに該当するものの設計に係る技術（プログラムを除く。）又はイ若しくはロに該当するもののために設計したCADプログラム

(vi) The technology (excluding programs) pertaining to devices for helicopters that falls under any of the following or a CAD programs designed for items that fall under (a) or (b)

イ 多軸のフライバイワイヤ方式又はフライバイライト方式の操縦装置であって、次に該当する機能のうち二以上を統合したもの

(a) Flight control devices for multi-spindle fly-by-wire systems or fly-by-light systems that integrate 2 or more functions among those that fall under the following

(一) コレクティブ制御機能

1. Collective control function

(二) サイクリック制御機能

2. Cyclic control function

(三) ヨー制御機能

3. Yaw control function

ロ 反トルク又は方向を制御する装置であつて、循環制御方式によるもの

(b) Devices that control counter torque or direction and by a means of a circulation control method

ハ 各翼を個別に制御するための可変形状翼を用いた回転翼

(c) Rotors that use blades of variable shape in order to control each aerofoil blade separately

七 前号のプログラムの設計に必要な技術（プログラムを除く。）

(vii) The technology (excluding programs) necessary for the design of the programs of the preceding item

第二十四条 外為令別表の一の二の項（一）の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

Article 24 (1) The technology specified by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 12 (i) of the appended table of the Foreign Exchange Order shall fall under any of the following.

一 第十一条第一号ロ、第四号ロ、第六号、第八号又は第十号へ若しくはトに該当するものの設計又は製造に必要な技術

(i) The technology necessary for the design or manufacture of items that fall under Article 11, item (i), (b), item (iv), (b), item (vi), item (viii) or item (x), (f) or (g)

二 第十一条に該当するもの（前号に該当するものを除く。）の設計又は製造に必要な技術

(ii) The technology necessary for the design or manufacture of items that fall under Article 11 (excluding those falling under the preceding item)

2 外為令別表の一の二の項（二）の経済産業省令で定める技術は、第十一条若しくは第十四条第九号若しくは第十号に該当する貨物を使用するために設計したプログラム又は第十一条第一号から第三号までのいずれか、第四号ロ若しくはハ、第八号、第九号ホからリまでのいずれか若しくは第十号若しくは第十四条第九号若しくは第十号に該当する貨物の使用（修理又はオーバーホールに係るものに限る。）に係る技術（プログラムを除く。）とする。

(2) The technology specified by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 12 (ii) of the appended table of the Foreign Exchange Order shall be technology pertaining to programs designed for the use of the goods that fall under Article 11 or Article 14, item (ix) or item (x), or the use of goods (limited to those pertaining to repairs or overhauls) that fall under any of Article 11, item (i) through item (iii), or any of item (iv), (b) or (c), item (viii),

item (ix), (e) through (i) or Article 10 or Article 14, item (ix) or item (x).

3 外為令別表の十二の項（三）の経済産業省令で定める技術は、水中ノイズを減少させるために設計したプロペラの設計、製造又は使用（修理又はオーバーホールに係るものに限る。）に係る技術とする。

(3) The technology specified by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 12 (iii) of the appended table of the Foreign Exchange Order shall be technology pertaining to the design or manufacture or use (limited to those pertaining to repairs or overhauls) of propellers designed for reducing underwater noise.

第二十五条 外為令別表の一三の項（一）の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

Article 25 (1) The technology specified by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 13 (i) of the appended table of the Foreign Exchange Order shall fall under any of the following.

一 第十二条第一号ロ、第四号から第十号まで又は第十一号から第十九号までのいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術（プログラムを除く。）

(i) The technology (excluding programs) necessary for the design or manufacture of items that fall under any of Article 12, item (i), (b), item (iv) through item (x) or item (xi) through item (xix)

二 第十二条第十一号ロに該当するものを設計し、又は製造するために設計したプログラム

(ii) Programs designed for the design or manufacture of items that fall under Article 12, item (xi), (b)

三 前号のプログラムの設計に必要な技術（プログラムを除く。）

(iii) The technology (excluding programs) necessary for the design of the programs of the preceding item

四 第十二条に該当するもの（第二号に該当するものを除く。）を設計し、又は製造するために設計したプログラム

(iv) Programs designed for the design or manufacture of items that fall under Article 12 (excluding those falling under item (ii))

五 前号のプログラムの設計に必要な技術（プログラムを除く。）

(v) The technology (excluding programs) necessary for the design of the programs in the preceding item

2 外為令別表の一三の項（二）の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

(2) The technology specified by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 13 (ii) of the appended table of the Foreign Exchange Order shall fall under any of the following.

一 第十二条に該当するものをフルオーソリティーデジタルエンジン制御するための装置を使用するために設計したプログラムであって、次のいずれかに該当するもの

- (i) Programs that are designed for the use of equipment for full authority digital engine control of items that fall under Article 12, and that fall under any of the following
- イ 推進装置又はその試験装置をデジタル制御するための装置に用いるためのもの
  - (a) Programs for use in equipment for digital control of propulsion equipment or test equipment therefor
  - ロ 推進装置又はその試験装置をフルオーソリティーデジタルエンジン制御するための装置の故障許容機能のためのもの
  - (b) Programs used for fault-tolerance functions of equipment for full authority digital engine control of propulsion equipment or test equipment therefor
- ニ 前号のプログラムの設計に必要な技術（プログラムを除く。）
- (ii) The technology (excluding programs) necessary for the design of the programs in the preceding item
- 三 プログラムであって、次のいずれかに該当するもの
- (iii) Programs that fall under any of the following
- イ 風洞試験又は飛行試験のデータにより検証された二次元又は三次元の粘性流れのためのプログラムであって、エンジン内の流れをモデリングするためのもの
  - (a) Programs for two dimensional or three dimensional viscous flow verified by the data of wind tunnel tests or flight tests and that model the flow inside engines
  - ロ 航空機用ガスタービンエンジン又はその部分品の試験のためのプログラムであって、実時間でデータを収集、処理及び解析し、かつ、試験中にフィードバック制御を行うように設計したもの
  - (b) Programs for testing aerial vehicle gas turbine engines or components thereof, and designed to collect, process and analyze the data in real time and also execute feedback control during testing
  - ハ 一方向性凝固又は単結晶の鋳造を制御するために設計したもの
  - (c) Programs designed to control unidirectional solidification or single crystal casting
  - ニ ブレードのチップクリアランスをアクティブ制御するための装置を使用するのに必要なプログラム（輸出令別表第一の中欄に掲げる貨物に該当しない貨物に埋め込まれたもの、校正若しくは修理を伴う保守作業に必要なもの又はチップクリアランスをアクティブ制御することができるように更新するために必要なものを除く。）
  - (d) Programs necessary for the use of equipments for active control of chip clearance of a blade (excluding those incorporated into the goods that do not fall under the goods listed in the middle column in the appended table 1 of the Export Order, those necessary for maintenance work accompanying calibration or repair or those necessary for revision to enable active control of chip clearance)

四 前号のプログラムの設計に必要な技術（プログラムを除く。）

(iv) The technology (excluding programs) necessary for the design of the programs in the preceding item

3 外為令別表の一三の項（三）の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

(3) The technology specified by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 13 (iii) of the appended table of the Foreign Exchange Order shall fall under any of the following.

一 第十二条第一号ロ、第四号から第十号まで又は第十一号から第十九号までのいずれかに該当するガスタービンエンジン又はその部分品の使用（修理又はオーバーホールに係るものに限る。）に係る技術（プログラムを除く。）

(i) The technology (excluding programs) pertaining to use of gas turbine engines or components thereof that fall under any of Article 12, item (i), (b), item (iv) through item (x) or item (xi) through item (xix) (limited to those pertaining to repairs or overhauls)

二 ガスタービンエンジンの部分品であって、次のいずれかに該当するものの設計若しくは製造に必要な技術（プログラムを除く。）又はその設計のためのプログラム

(ii) The technology (excluding programs) necessary for the design or manufacture of components of gas turbine engines that fall under any of the following or programs for the design thereof

イ 多段ドーム式燃焼器であって、燃焼器の出口における平均温度が一、五四〇度を超えるもの又は燃焼器であって、熱遮断燃焼器ライナー、非金属ライナー若しくは非金属シェルを用いたもの

(a) Multi stage dome type combustors average temperature at the outlet of exceeds 1,540 degrees centigrade or combustors whose that use heat shielding combustor liners, non-metallic liners or non-metallic shells

ロ 第四条第十二号に該当する金属マトリックス複合材、セラミックマトリックス、金属間化合物若しくは金属間化合物強化材料から製造された部分品又は同条第十三号に該当する樹脂を用いて同条第十五号に該当する複合材から製造された部分品

(b) Components manufactured from metallic matrix composite materials, ceramic matrix, inter-metallic compounds or inter-metallic reinforcing materials that fall under Article 4, item (xii) or components manufactured from the composite materials that fall under item (xv) of the same Article using the resin that falls under item (xiii) of the same Article

ハ 無冷却式のブレード、ベーン、チップシュラウド又はその他の部分品であって、一、〇五〇度以上のガス流路温度で使用することができるもの

(c) Non-cooling type blades, vanes, chip shrouds or other components that can be used in a gas path at 1,050 degrees centigrade or more

ニ 冷却式のブレード、ベーン又はチップシュラウドであって、一、三七〇度以上のガス流路温度で使用することができるもの（第二十七条第五項第一号に該当す

るものを除く。)

(d) Cooling type blades, vanes, chip shrouds that can be used in a gas flow path at 1,370 degrees centigrade or more (excluding those that fall under Article 27, paragraph (5), item (i))

ホ 固相接合法を用いてタービンブレードの翼部とディスク部を接合したもの

(e) Components that join a wing part and a disk part of turbine blade using a solid phase bonding method

ヘ 第十八条第四項に該当する拡散接合法を用いたもの

(f) Components that use a diffusion bonding method that falls under Article 18, item (iv)

ト 損傷許容設計された回転部分品であって、粉末冶金材料（第四条第七号ロに該当するものに限る。）を用いたもの

(g) Rotation part components that are designed for damage tolerance and that use powdered metallurgical materials (limited to those that fall under Article 4, item (vii), (b))

チ ガスタービンエンジン若しくは複合サイクルエンジンをフルオーソリティーデジタルエンジン制御するための装置又はそのセンサー若しくは部分品

(h) Equipments for providing gas turbine engines or composite cycle engines with full authority digital engine control or sensors therefor or components thereof

リ 流路の形状を可変にするためのもの（入口案内翼、可変ピッチファン又は圧縮機の可変ステータ若しくはブリードバルブを除く。）又はその制御装置であって、次のいずれかに該当する貨物のためのもの（逆推力のためのものを除く。）

(i) Components that make flow path shapes adjustable (excluding inlet guide vanes, variable pitch fans or compressor variable stators or bleed valves) or control devices thereof, and those for goods that fall under any of the following (excluding those for reverse thrust)

(一) ガスジェネレータータービン

1. Gas generator turbines

(二) ファンタービン又はパワータービン

2. Fan turbines or power turbines

(三) プロペリングノズル

3. Propelling nozzle

ヌ 中空のファンブレードであって、スパン中間での支持がないもの

(j) Hollow fan blades without a support in the middle of a span thereof

ル レーザー加工、ウォータージェット加工、電解加工又は放電加工により次のいずれかに該当する穴を穴あけ加工したもの

(k) Components subjected to boring of openings that fall under any of the following by laser beam machining, water jet machining, electrolysis machining or electrical discharge machining

(一) 穴の深さが直径の四倍を超え、直径が〇・七六ミリメートル未満であつ



て、穴あけ角度が二五度以下のもの

1. Components the hole depth of which exceeds 4 times the diameter and the diameter of which is less than 0.76 millimeters and the boring angle of which is 25 degrees or less

(二) 穴の深さが直径の五倍を超え、直径が〇・四ミリメートル未満であって、穴あけ角度が二五度を超えるもの

2. Components the hole depth of which exceeds 5 times the diameter and the diameter of which is less than 0.4 millimeters and the boring angle of which exceeds 25 degrees

4 外為令別表の一三の項（四）の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するもの又はその設計のためのプログラムとする。

(4) The technology specified by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 13 (iv) of the appended table of the Foreign Exchange Order shall fall under any of the following, or under programs for the design thereof.

一 風洞用の模型であって、流れの状態に影響を与えない形のセンサーを用いたもの  
のうち、センサーからデータ収集装置にデータを送信できるものの設計又は製造に  
必要な技術（プログラムを除く。）

(i) Technology (excluding programs) necessary for the design or manufacture of, among wind tunnel models that use sensors that do not impede flow conditions, those capable of transmitting data from sensors to data collecting devices

二 複合材を用いたプロペラブレード又はプロップファンであって、マッハ数が〇・五五を超える速度において二、〇〇〇キロワットを超える負荷を吸収することができるものの設計又は製造に必要な技術（プログラムを除く。）

(ii) Technology (excluding programs) necessary for the design or manufacture of propeller blades or prop fans that use composite materials and that are capable of absorbing loads that exceeds 2,000 kilowatts at speeds exceeding Mach 0.55

三 ヘリコプター又はチルトロータ若しくはチルトウィングを用いた航空機の動力伝達装置の設計又は製造に必要な技術（プログラムを除く。）

(iii) Technology (excluding programs) necessary for the design or manufacture of power transmission devices for aircraft that use helicopters or tilt rotors or tilt wings

5 外為令別表の一三の項（五）の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するもの又はその設計のためのプログラムとする。

(5) The technology specified by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 13 (v) of the appended table of the Foreign Exchange Order shall fall under any of the following or the programs for the design thereof.

一 車両用の往復動ディーゼルエンジンであって、次のイからハまでのすべてに該当

するものの設計又は製造に係る技術（プログラムを除く。）

(i) The technology (excluding programs) pertaining to the design or manufacture of reciprocating diesel engines for vehicles that fall under all of the following (a) through (c)

イ エンジン体積が一・二立方メートル以下のもの

(a) Diesel engines with the engine volume of 1.2 cubic meters or less

ロ グロス軸出力が七五〇キロワットを超えるもの

(b) Diesel engines with a gross shaft power exceeding 750 kilowatts

ハ キロワットで表したグロス軸出力を立方メートルで表したエンジン体積で除した値が七〇〇を超えるもの

(c) Diesel engines for which the gross brake power expressed in kilowatts divided by the engine volume expressed in cubic meters exceeds 700

二 高出力ディーゼルエンジン（定格回転数が一分につき二、三〇〇回以上であって、かつ、回転数が一分につき二、三〇〇回の時の正味平均有効圧力が一・八メガパスカル以上のディーゼルエンジンをいう。以下この条において同じ。）の部分品の製造に必要な技術（プログラムを除く。）であって、次のいずれかに該当するもの

(ii) Technology (excluding programs) necessary for the manufacture of the components of high-output diesel engines (this shall mean diesel engines in which the rated rotational speed is 2,300 or more revolutions per minute (RPM) and in which the brake average effective pressure is 1.8 megapascals or more when the RPM is 2,300; hereinafter the same shall apply in this Article), that fall under any of the following

イ 次の（一）から（三）までのすべての部分品が第四条第十二号に該当するセラミックで作られたエンジン（これらの部分品以外のすべての部分品が当該セラミック以外のもので作られているものを除く。）の製造に必要な技術

(a) Technology necessary for the manufacture of engines all components of which, from the following 1. through 3., are made of ceramics that fall under Article 4, item (xii) (excluding those all components of which, other than the said components are made of materials other than the said ceramics)

（一） シリンダーライナ

1. Cylinder liners

（二） ピストン

2. Pistons

（三） シリンダーヘッド

3. Cylinder heads

ロ ターボ過給機であって、その圧縮機が次の（一）から（三）までのすべてに該当するものの製造に必要な技術

(b) The technology necessary for the manufacture of turbochargers, the compressor of which falls under all of following 1. through 3.

（一） 一段当たりの圧力比が四以上のもの

1. Turbosuperchargers Compressors the pressure ratio per stage of which is 4 or more
    - (二) 流量が一分につき三〇キログラム以上一三〇キログラム以下のもの
  2. Turbosuperchargers Compressors the flow volume per minute of which is 30 kilograms or more and 130 kilograms or less
    - (三) 圧縮機又はそのタービン部分の流路面積を変えることができるもの
  3. Turbosuperchargers Compressors flow area of compressors of which or that of its turbine parts can be modified
- ハ 燃料噴射装置であつて、三七・八度における動粘度が〇・五センチストークス以上二・五センチストークス以下のいずれの燃料にも用いることができるように設計したもののうち、次の（一）及び（二）に該当するものの製造に必要な技術
- (c) Technology necessary for the manufacture of, among fuel injection devices designed so as to use any of the fuels the dynamic viscosity of which at 37.8 degrees centigrade is 0.5 centistokes or more and 2.5 centistokes or less, those that fall under the following 1. and 2.
- (一) 噴射量が一気筒一噴射当たり二三〇立方ミリメートルを超えるもの
1. Fuel injection devices in which the injection amount exceeds 230 cubic millimeters per cylinder injection
    - (二) 燃料の特性に応じて同じトルク特性を得るように調速機の特性を自動的に切り替えることができるように電子制御するもの
  2. Fuel injection devices that are controlled electronically so that adjuster characteristics can be automatically switched in order to obtain the same torque characteristics in response to fuel characteristics
- 三 ピストンのトップリングの上死点位置において計測したシリンダーの壁面温度が四五〇度を超える高出力ディーゼルエンジンであつて、シリンダー壁面に固体、気相又は液体の潤滑剤を用いたものの設計又は製造に必要な技術（プログラムを除く。）
- (iii) Technology (excluding programs) necessary for the design or manufacture of high output diesel engines the wall surface temperature of which exceeds 450 degrees centigrade measured at the top dead center of the piston top ring and that use solid, gas phase or liquid lubricants on cylinder wall surfaces

第二十六条 外為令別表の一四の項の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

Article 26 The technology specified by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 14 of the appended table of the Foreign Exchange Order shall fall under any of the following.

一 第十三条に該当するものの設計、製造又は使用に必要な技術（プログラムを除く。）

(i) The technology (excluding programs) necessary for the design or manufacture of items that fall under Article 13

二 第十三条に該当するものを設計し、製造し、若しくは使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に必要な技術（プログラムを除く。）

(ii) Programs designed for the design, manufacture or use of items that fall under Article 13 or technology (excluding programs) necessary for the design, manufacture or use of those programs

第二十七条 外為令別表の一五の項（一）の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

Article 27 (1) The technology specified by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 15 (i) of the appended table of the Foreign Exchange Order shall fall under any of the following.

一 第十四条第一号から第三号までのいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術（プログラムを除く。）

(i) The technology (excluding programs) necessary for the design or manufacture of items that fall under any of Article 14, item (i) through item (iii)

二 第十四条第六号又は第七号に該当するものの設計又は製造に必要な技術（プログラムを除く。）

(ii) The technology (excluding programs) necessary for the design or manufacture of items that fall under Article 14, item (vi) or item (vii)

三 第十四条第五号、第八号又は第十一号に該当するものの設計又は製造に必要な技術

(iii) The technology necessary for the design or manufacture of items that fall under Article 14, item (v), item (viii) or item (xi)

四 第十四条第九号又は第十号に該当するものの設計又は製造に必要な技術

(iv) The technology necessary for the design or manufacture of items that fall under Article 14, item (ix) or item (x)

五 第三号に該当するものを設計し、又は製造するために設計したプログラムの設計に必要な技術（プログラムを除く。）

(v) The technology (excluding programs) necessary for the design of programs designed for the design or manufacture of items that fall under item (iii)

2 外為令別表の一五の項（三）の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するプログラム又はそのプログラムの設計若しくは製造に必要な技術とする。

(2) The technology specified by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 15 (iii) of the appended table of the Foreign Exchange Order shall be programs that fall under any of the following or the technology necessary for the design or manufacture of those programs.

一 えい航ハイドロホンアレーを用いて受信した音響データの実時間処理のための音響ビーム成形を行うために設計したもの

(i) Programs designed for carrying out acoustic beam molding for real time

- processing of sound data received by using towed hydrophone arrays
- 二 えい航ハイドロホンアレーを用いて受信した音響データの実時間処理を行うためのソースコード
- (ii) Source code for executing real time processing of sound data received by using towed hydrophone arrays
- 三 海底用又は港湾用ケーブルシステムを用いて受信した音響データの実時間処理のための音響ビーム成形を行うために設計したもの
- (iii) Programs designed for carrying out acoustic beam molding for real time processing of sound data received by using ocean bottom or harbor/port cable systems
- 四 海底用又は港湾用ケーブルシステムを用いて受信した音響データの実時間処理を行うためのソースコード
- (iv) Source code for executing real time processing of sound data received by using ocean bottom or harbor/ bay cable systems
- 3 外為令別表の一五の項（四）の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するプログラムとする。
- (3) The technology specified by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 15 (iv) of the appended table of the Foreign Exchange Order shall fall under any of the following.
- 一 慣性航法装置その他の慣性装置に用いることによって、これらの装置を第十条第三号、第三号の二又は第三号の三に該当するようにすることができるように設計したプログラム
- (i) Programs designed so that these systems can fall under Article 10, item (iii), item (iii)-2 or item (iii)-3 due to their using inertial navigation systems or other inertial systems
- 二 慣性航法データと次のいずれかに該当する航法データを連続的に統合し、慣性航法装置その他の慣性装置に用いることによって、これらの装置を第十条第三号、第三号の二又は第三号の三に該当するようにすることができるプログラム（ソースコードのものに限る。）
- (ii) Programs that enable devices to fall under Article 10, item (iii), item (iii)-2 or item (iii)-3 due to their using inertial navigation systems or other inertial systems and continuously integrating inertial navigation data and navigation data that falls under any of the following (limited to those with source code)
- イ ドップラー効果を利用するレーダーからの速度データ
- (a) Speed data from radars that utilize Doppler effects
- ロ ジーピーエス又はグローナスからの航法データ
- (b) Navigation data from GPS or Glonass
- ハ データベース参照航法装置からのデータ
- (c) Data from database reference navigation equipment
- 4 外為令別表の一五の項（五）の経済産業省令で定める技術は、ジャイロ天測航法装

置又は天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置に用いることによって、その装置を第十条第四号に該当するようにすることができるように設計したプログラムとする。

(4) The technology specified by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 15 (v) of the appended table of the Foreign Exchange Order, shall be programs designed so that the devices can fall under Article 10, item (iv) due to its using in Gyro-astro compasses, or devices that derive position or orientation by means of automatically tracking celestial bodies or satellites.

5 外為令別表の一五の項（六）の経済産業省令で定める技術は、ガスタービンエンジンの部分品であって、次のいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術（プログラムを除く。）とする。

(5) The technology specified by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 15 (vi) of the appended table of the Foreign Exchange Order shall be technology necessary for the design or manufacture of gas turbine engine components that fall under any of the following.

一 一方向性凝固又は単結晶の合金で鋳造されたガスタービンのブレード、ベーン又はチップシュラウドであって、一、〇〇〇度の温度において結晶面に垂直な方向に二〇〇メガパスカルの応力が発生する荷重を加えたときの応力破断時間が四〇〇時間以上のもの

(i) Gas turbine blades, vanes or chip shrouds cast by unidirectional solidification or single crystal alloy methods, the stress breakage time of which is 400 hours or more when a load that generates a 200 megapascals stress is applied in the vertical direction to the crystal surface at 1,000 degrees centigrade

二 有機複合材を用いた部分品であって、三一五度を超える温度で使用することができるように設計したもの

(ii) Components that use organic composite materials and are designed for use at exceeding 315 degrees centigrade

第二十八条 外為令別表の一六の項（一）の経済産業省令で定める技術は、第十四条の二に規定する貨物の設計、製造又は使用に専ら係る技術とする。

Article 28 (1) The technology specified by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 16 (i) of the appended table of the Foreign Exchange Order shall be technology exclusively pertaining to the design, manufacture or use of goods prescribed in Article 14-2.

2 外為令別表の一六の項（二）の経済産業省令で定める技術は、関税定率法（明治四十三年法律第五十四号）別表第二五類から第四〇類まで、第五四類から第五九類まで、第六三類、第六八類から第九三類まで又は第九五類に該当する貨物の設計、製造又は使用に専ら係る技術とする。

(2) The technology specified by the Ordinance of the Ministry of Economy, Trade

and Industry in row 16 (ii) of the appended table of the Foreign Exchange Order shall be technology exclusively pertaining to the design, manufacture or use of goods that fall under Class 25 through Class 40, Class 54 through 59, Class 63, Class 68 through Class 93, or Class 95 of the appended table of Custom Tariff Act (Act No. 54 of 1910).

**附 則**

**Supplementary Provisions**

この省令は、平成三年十一月十四日から施行する。

This Ordinance of the Ministry shall come into effect as from November 14, 1991.

**附 則** [平成四年三月二十七日通商産業省令第十二号]

**Supplementary Provisions [Ordinance of the Ministry of International Trade and Industry No. 12 of March 27, 1992]**

この省令は、平成四年四月一日から施行する。

This Ordinance of the Ministry shall come into effect as from April 1, 1992.

**附 則** [平成四年十二月九日通商産業省令第八十五号]

**Supplementary Provisions [Ordinance of the Ministry of International Trade and Industry No. 85 of December 9, 1992]**

1 この省令は、平成四年十二月三十一日から施行する。

(1) This Ordinance of the Ministry shall come into effect as from December 31, 1992.

2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(2) With regard to the application of penal provisions to acts committed prior to the enforcement of this Ordinance of the Ministry, the provisions then in force shall remain applicable.

**附 則** [平成五年六月十八日通商産業省令第三十号]

**Supplementary Provisions [Ordinance of the Ministry of International Trade and Industry No. 30 of June 18, 1993]**

この省令は、平成五年七月十六日から施行する。ただし、第三条及び第十六条第二項の改正規定は、平成五年七月一日から施行する。

This Ordinance of the Ministry shall come into effect as from July 16, 1993; provided, however, that the revised provisions of Article 3 and Article 16, paragraph (2) shall come into effect as from July 1, 1993.

附 則 〔平成五年十二月一日通商産業省令第八十五号〕

**Supplementary Provisions [Ordinance of the Ministry of International Trade and Industry No. 85 of December 1, 1993]**

- 1 この省令中第一条の規定は、公布の日から、第二条の規定は、平成五年十二月二十二日から施行する。
- (1) The provision of Article 1 in this Ordinance of the Ministry shall come into effect as from the date of promulgation, and the provisions of Article 2 shall come into effect as from December 22, 1993.
- 2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- (2) With regard to the application of penal provisions to acts committed prior to the enforcement of this Ordinance of the Ministry, the provisions then in force shall remain applicable.

附 則 〔平成六年一月二十八日通商産業省令第三号〕

**Supplementary Provisions [Ordinance of the Ministry of International Trade and Industry No. 3 of January 28, 1994]**

この省令は、公布の日から施行する。

This Ordinance of the Ministry shall come into effect as from the date of promulgation.

附 則 〔平成六年三月十四日通商産業省令第十号〕

**Supplementary Provisions [Ordinance of the Ministry of International Trade and Industry No. 10 of March 14, 1994]**

- 1 この省令は、平成六年三月二十八日から施行する。ただし、第二条の改正規定、第七条の改正規定（同条第三号ニ中「次のいずれかに該当するもの」を「計算要素を集合させることにより、複合理論性能が一秒につき二六〇メガ演算を超えるもの」に改め、（一）及び（二）を削る部分を除く。）及び第八条の改正規定は、公布の日から施行する。
- (1) This Ordinance of the Ministry shall come into effect as from March 28, 1994; provided, however, that the revised provisions of Article 2, the revised provisions of Article 7 (in item (iii), (d) of the same Article, "equipment that corresponds to any of the following" shall be revised to "equipment the composite theoretical performance of which exceeds 260 mega calculations per seconds by aggregating calculation elements", and except for the part that deletes 1. and 2.) and the revised provisions of Article 8 shall come into effect as from the date of promulgation.
- 2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



- (2) With regard to the application of penal provisions to acts committed prior to the enforcement of this Ordinance of the Ministry, the provisions then in force shall remain applicable.

**附 則** 〔平成六年六月二十四日通商産業省令第四十九号〕

**Supplementary Provisions [Ordinance of the Ministry of International Trade and Industry No. 49 of June 24, 1994]**

- 1 この省令は、平成六年七月六日から施行する。ただし、第七条の改正規定（同条第五号及び第六号を削る部分に限る。）及び第二十条の改正規定（同条第一項第五号から第九号までを削る部分を除く。）は、公布の日から施行する。

- (1) This Ordinance of the Ministry shall come into effect as from July 6, 2004; provided, however, that the revised provisions of Article 7 (limited to the part deleting item (v) and item (vi) of the same Article) and the revised provisions of Article 20 (excluding the part deleting paragraph (1), item (v) through item (ix) of the same Article) shall come into effect as from the date of promulgation.

- 2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

- (2) With regard to the application of penal provisions to acts committed prior to the enforcement of this Ordinance of the Ministry, the provisions then in force shall remain applicable.

**附 則** 〔平成七年二月二十七日通商産業省令第二号〕

**Supplementary Provisions [Ordinance of the Ministry of International Trade and Industry No. 2 of February 27, 1995]**

- 1 この省令は、公布の日から施行する。

- (1) This Ordinance of the Ministry shall come into effect as from the date of promulgation.

- 2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

- (2) With regard to the application of penal provisions to acts committed prior to the enforcement of this Ordinance of the Ministry, the provisions then in force shall remain applicable.

**附 則** 〔平成七年五月十日通商産業省令第四十三号〕

**Supplementary Provisions [Ordinance of the Ministry of International Trade and Industry No. 43 of May 10, 1995]**

- 1 この省令は、平成七年五月二十二日から施行する。

- (1) This Ordinance of the Ministry shall come into effect as from May 22, 1995.

- 2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

- (2) With regard to the application of penal provisions to acts committed prior to

the enforcement of this Ordinance of the Ministry, the provisions then in force shall remain applicable.

**附 則** 〔平成七年十二月二十日通商産業省令第百六号〕

**Supplementary Provisions [Ordinance of the Ministry of International Trade and Industry No. 106 of December 20, 1995]**

- 1 この省令は、平成八年一月三日から施行する。ただし、第一条の改正規定、第二条のこの改正規定（同条第一項第一号及び第二号中「生ワクチンの成分であるもの」を「ワクチン」に改め、同項第三号中「毒素」の下に「（免疫毒素を除く。）」を加える部分に限る。）、第五条の改正規定、第十五条の改正規定及び第十八条の改正規定は、公布の日から施行する。
- (1) This Ordinance of the Ministry shall come into effect as from January 3, 1996; provided, however, that the revised provisions of Article 1, the revised provisions of Article 2-2 (limited to the parts in which "Fresh vaccine ingredients" in paragraph (1), item (i) and item (ii) of the same Article is revised to "vaccine" and "(excluding immune toxin)" is added under "toxin" in item (iii) of the same paragraph), and the revised provisions of Article 5, the revised provisions of Article 15 and the revised provisions of Article 18 shall come into effect as from the date of promulgation.
- 2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- (2) With regard to the application of penal provisions to acts committed prior to the enforcement of this Ordinance of the Ministry, the provisions then in force shall remain applicable.

**附 則** 〔平成八年三月二十八日通商産業省令第十八号〕

**Supplementary Provisions [Ordinance of the Ministry of International Trade and Industry No. 18 of March 28, 1996]**

この省令は、平成八年十月一日から施行する。

This Ordinance of the Ministry shall come into effect as from October 1, 1996.

**附 則** 〔平成八年八月二十八日通商産業省令第六十号〕 〔抄〕

**Supplementary Provisions [Ordinance of the Ministry of International Trade and Industry No. 60 of August 28, 1996] [Extract]**

（施行期日）

（Effective date）

- 1 この省令は、平成八年九月十三日から施行する。
- (1) This Ordinance of the Ministry shall come into effect as from September 13, 1996.

(罰則に関する経過措置)

(Transitional Measures pertaining to Penal Provisions)

2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(2) With regard to the application of penal provisions to acts committed prior to the enforcement of this Ordinance of the Ministry, the provisions then in force shall remain applicable.

附 則 [平成九年四月三日通商産業省令第六十五号]

**Supplementary Provisions [Ordinance of the Ministry of International Trade and Industry No. 65 of April 3, 1997]**

この省令は、平成九年四月二十九日から施行する。

This Ordinance of the Ministry shall come into effect as from April 29, 1997.

附 則 [平成十年三月十二日通商産業省令第九号]

**Supplementary Provisions [Ordinance of the Ministry of International Trade and Industry No. 9 of March 12, 1998]**

この省令は、平成十年四月一日から施行する。

This Ordinance of the Ministry shall come into effect as from April 1, 1998.

附 則 [平成十年三月二十五日通商産業省令第十三号]

**Supplementary Provisions [Ordinance of the Ministry of International Trade and Industry No. 13 of March 25, 1998]**

(施行期日)

(Effective Date)

1 この省令は、平成十年四月一日から施行する。

(1) This Ordinance of the Ministry shall come into effect as from April 1, 1998.

(罰則に関する経過措置)

(Transitional Measures pertaining to Penal Provisions)

2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(2) With regard to the application of penal provisions to acts committed prior to the enforcement of this Ordinance of the Ministry, the provisions then in force shall remain applicable.

附 則 [平成十年八月二十六日通商産業省令第七十八号]

**Supplementary Provisions [Ordinance of the Ministry of International Trade and Industry No. 78 of August 26, 1998]**

(施行期日)

(Effective Date)

1 この省令は、公布の日から施行する。

(1) This Ordinance of the Ministry shall come into effect as from the date of promulgation.

(罰則に関する経過措置)

(Transitional Measures pertaining to Penal Provisions)

2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(2) With regard to the application of penal provisions to acts committed prior to the enforcement of this Ordinance of the Ministry, the provisions then in force shall remain applicable.

**附 則** 〔平成十年十一月五日通商産業省令第八十三号〕

**Supplementary Provisions [Ordinance of the Ministry of International Trade and Industry No. 83 of November 5, 1998]**

この省令は、平成十年十一月十二日から施行する。

This Ordinance of the Ministry shall come into effect as from November 12, 1998.

**附 則** 〔平成十一年六月十八日通商産業省令第六十四号〕

**Supplementary Provisions [Ordinance of the Ministry of International Trade and Industry No. 64 of June 18, 1999]**

(施行期日)

(Effective Date)

1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) This Ordinance of the Ministry shall come into effect as from the date of promulgation; provided, however, that the provisions listed in each of the following those shall come in effect as from the date to be determined for each item.

一 第一条の改正規定、第四条第九号の改正規定、第五条第七号の改正規定、第六条第十七号イ及びへの改正規定、第九条第十号ロの改正規定、第十四条の二第二号の改正規定、第十九条第三項及び第五項の改正規定、第二十一条第一項第十号の二、第十一号の二、第十三号及び第十五号並びに同条第二項第四号、第四号の二及び第十一号の改正規定、別表第三の改正規定 平成十一年七月二日

(i) The revised provisions of Article 1, the revised provisions of Article 4, item (ix), the revised provisions of Article 5, item (vii), the revised provisions to

Article 6, item (xvii), (a) and (f), the revised provisions of Article 9, item (x), (b), the revised provisions of Article 14-2, item (ii), the revised provisions of Article 19, paragraph (3) and paragraph (5), the revised provisions of Article 21, paragraph (1), item (x)-2, item (xi)-2, item (xiii) and item (xv) and paragraph (2), item (iv), item (iv)-2 and item (xi) of the same Article, the revised provisions of the appended table 3: July 2, 1999

二 第二条第一項の改正規定及び第十四条の二第五十一号の二から第五十一号の四までの追加規定 平成十一年七月十八日

(ii) The revised provisions of Article 2, paragraph (1) and the additional provisions from Article 14-2, item (li)-2 through item (li)-4: July 18, 1999

(罰則に関する経過措置)

(Transitional Measures pertaining to Penal Provisions)

2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(2) With regard to the application of penal provisions to acts committed prior to the enforcement of this Ordinance of the Ministry, the provisions then in force shall remain applicable.

附 則 [平成十二年六月二十三日通商産業省令第百十五号]

**Supplementary Provisions [Ordinance of the Ministry of International Trade and Industry No. 115 of June 23, 2000]**

(施行期日)

(Effective Date)

1 この省令は、平成十二年七月七日から施行する。ただし、第一条第八号、第九号、第十一号、第十四号、第十八号、第二十一号、第二十二号、第二十四号イ及びハ、第二十七号及び第三十三号の改正規定、同条第三十四号の改正規定（同号イ（一）及びロ（一）中「七五ミリメートル以上の」を「七五ミリメートルを超える」に改める部分に限る。）、同条第三十五号、第三十六号、第三十八号、第四十号、第四十四号並びに第五十七号、第三条第七号ホ、第十六号イ及びト、第二十号並びに第二十二号の改正規定、第六条第一号の改正規定（同号ハ（三）中「並列プロセッサ」を「並列プロセッサ用に設計したもの」に改める部分を除く。）、同条第二号ロ、第四号及び第八号、第七条、第八条、第九条第一号イ、第十二条、第十三条第五項、第十四条第五号並びに第六号イ及びニ、第十四条の二第七十四号、第十九条、第二十条並びに第二十一条の改正規定並びに第二十五条の改正規定（同条第三項第二号中ヌを削り、ルをヌとし、ヲをルとする部分に限る。）は、公布の日から施行する。

(1) This Ordinance of the Ministry shall come into effect as from July 7, 2000; provided, however, that the following shall come into effect as from the date of promulgation: the revised provisions of Article 1, item (viii), item (ix), item (xi), item (xiv), item (xviii), item (xxi), item (xxii), item (xxiv), (a) and (c), item (xxvii) and item (xxxiii); the revised provisions of item (xxxiv) of the same

Article (limited to the part in which "those that are 75 millimeters or more" in (a), 1. and (b), 2. of the same item is revised to "those that exceed 75 millimeters"); the revised provisions of item (xxxv), item (xxxvi), item (xxxviii), item (xl), item (xliv) and also item (lvii) of the same Article, Article 3, item (vii), (e), item (xvi), (a) and (g), item (xx) and item (xxii); the revised provisions of Article 6, item (i) (excluding the part in which "parallel processors" in (c), 3. of the same item is revised to "devices designed for parallel processors"); and the revised provisions of item (ii), (b), item (iv) and item (viii) of the same Article, Article 7, Article 8, Article 9, item (i), (a), Article 12, Article 13, item (v), Article 14, item (v) and item (vi), (a) and (d), Article 14-2, item (lxxiv), Article 19, Article 20 and Article 21; and the revised provisions of Article 25 (limited to the part in which paragraph (3), item (ii), (j) of the same Article is deleted and (k) is changed to (j) and (l) is changed to (k))

(罰則に関する経過措置)

(Transitional Measures pertaining to Penal Provisions)

- 2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- (2) With regard to the application of penal provisions to acts committed prior to the enforcement of this Ordinance of the Ministry, the provisions then in force shall remain applicable.

**附 則** 〔平成十二年十月三十一日通商産業省令第二百六十五号〕

**Supplementary Provisions [Ordinance of the Ministry of International Trade and Industry No. 265 of October 31, 2000]**

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

This Ordinance of the Ministry shall come into effect as from January 6, 2001.

**附 則** 〔平成十二年十二月二十七日通商産業省令第四百八号〕

**Supplementary Provisions [Ordinance of the Ministry of International Trade and Industry No. 408 of December 27, 2000]**

(施行期日)

(Effective date)

- 1 この省令は、公布の日から施行する。
- (1) This Ordinance of the Ministry shall come into effect as from the date of promulgation.

(罰則に関する経過措置)

(Transitional Measures pertaining to Penal Provisions)

- 2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

- (2) With regard to the application of penal provisions to acts committed prior to the enforcement of this Ordinance of the Ministry, the provisions then in force shall remain applicable.

**附 則** 〔平成十三年五月十六日経済産業省令第百六十三号〕

**Supplementary Provisions [Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry No. 163 of May 16, 2001]**

(施行期日)

(Effective date)

- 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条第十号ロ、第二条の二、第四条、第五条第二号ロ、第八号及び第十号、第六条第二号、第五号、第十七号及び第十八号の改正規定、第九条第八号の改正規定（同号ロ（六）中「組み込んだもの」を「組み込んだビデオカメラ」に改める部分を除く。）、第十条、第二十一条第二項第三号の二ニ及び別表第三の備考の第十六号の改正規定は、平成十三年五月三十日から施行する。

- (1) This Ordinance of the Ministry shall come into effect as from the date or promulgation; provided, however, that Article 1, item (x), (b), Article 2-2, Article 4, Article 5, item (ii), (b), item (viii) and item (x), Article 6, item (ii), item (v), item (xvii) and item (xviii); the revised provisions of Article 9, item (viii) (excluding the part in which "built-in devices" in (b), 6. of the same item is revised to "built-in video cameras"); the revised provisions of Article 10, Article 21, paragraph (2), item (iii)-2, (d) and item (xvi) of the comments of the appended table 3 shall come into effect as from May 30, 2001.

(罰則に関する経過措置)

(Transitional Measures pertaining to Penal Provisions)

- 2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

- (2) With regard to the application of penal provisions to acts committed prior to the enforcement of this Ordinance of the Ministry, the provisions then in force shall remain applicable.

**附 則** 〔平成十三年十二月二十八日経済産業省令第二百四十七号〕

**Supplementary Provisions [Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry No. 247 of December 28, 2001]**

(施行期日)

(Effective date)

- 1 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

- (1) This Ordinance of the Ministry shall come into effect as from April 1, 2002.

(罰則に関する経過措置)

(Transitional Measures pertaining to Penal Provisions)

2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(2) With regard to the application of penal provisions to acts committed prior to the enforcement of this Ordinance of the Ministry, the provisions then in force shall remain applicable.

**附 則** [平成十四年六月十四日経済産業省令第八十五号]

**Supplementary Provisions [Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry No. 85 of June 14, 2002]**

(施行期日)

(Effective date)

1 この省令は平成十四年七月十五日から施行する。

(1) This Ordinance of the Ministry shall come into effect as from July 15, 2002.

(罰則に関する経過措置)

(Transitional Measures pertaining to Penal Provisions)

2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(2) With regard to the application of penal provisions to acts committed prior to the enforcement of this Ordinance of the Ministry, the provisions then in force shall remain applicable.

**附 則** [平成十四年十月二十一日経済産業省令第百八号]

**Supplementary Provisions [Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry No. 108 of October 21, 2002]**

(施行期日)

(Effective date)

1 この省令は平成十四年十一月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、平成十五年一月一日から施行する。

(1) This Ordinance of the Ministry shall come into effect as from November 1, 2002; provided, however, that the revised provisions of Article 2 shall come into effect as from January 1, 2003.

(罰則に関する経過措置)

(Transitional Measures pertaining to Penal Provisions)

2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(2) With regard to the application of penal provisions to any acts committed prior to the enforcement of this Ordinance of the Ministry, provisions then in force shall remain applicable.



附 則 〔平成十五年四月一日経済産業省令第五十二号〕

**Supplementary Provisions [Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry No. 52 of April 1, 2003]**

この省令は、公布の日から施行する。

This Ordinance of the Ministry shall come into effect as from the date of promulgation.

附 則 〔平成十五年十二月二十四日経済産業省令第百五十九号〕

**Supplementary Provisions [Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry No. 159 of December 24, 2003]**

(施行期日)

(Effective date)

1 この省令は、平成十六年一月二十日から施行する。

(1) This Ordinance of the Ministry shall come into effect as from January 20, 2004.

(罰則に関する経過措置)

(Transitional Measures pertaining to Penal Provisions)

2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(2) With regard to the application of penal provisions to acts committed prior to the enforcement of this Ordinance of the Ministry, the provisions then in force shall remain applicable.

附 則 〔平成十六年十一月十日経済産業省令第百四号〕

**Supplementary Provisions [Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry No. 104 of November 10, 2004]**

(施行期日)

(Effective date)

1 この省令は、平成十七年一月一日から施行する。

(1) This Ordinance of the Ministry shall come into effect as from January 1, 2005.

(罰則に関する経過措置)

(Transitional Measures pertaining to Penal Provisions)

2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(2) With regard to the application of penal provisions to acts committed prior to the enforcement of this Ordinance of the Ministry, the provisions then in force shall remain applicable.

附 則 〔平成十七年十二月二日経済産業省令第百十六号〕

**Supplementary Provisions [Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry No. 116 of December 2, 2005]**

(施行期日)

(Effective date)

1 この省令は、平成十八年一月一日から施行する。

(1) This Ordinance of the Ministry shall come into effect as from January 1, 2006.

(罰則に関する経過措置)

(Transitional Measures pertaining to Penal Provisions)

2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(2) With regard to the application of penal provisions to acts committed prior to the enforcement of this Ordinance of the Ministry, the provisions then in force shall remain applicable.

附 則 〔平成十八年十一月十七日経済産業省令第九十七号〕

**Supplementary Provisions [Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry No. 97 of November 17, 2006]**

この省令は、平成十九年一月一日から施行する。

This Ordinance of the Ministry shall come into effect as from January 1, 2007.

附 則 〔平成二十年三月二十六日経済産業省令第二十一号〕

**Supplementary Provisions [Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry No. 21 of March 26, 2008]**

(施行期日)

(Effective Date)

1 この省令は、平成二十年五月十五日から施行する。

(1) This Ordinance of the Ministry shall come into effect as from May 15, 2008.

(罰則に関する経過措置)

(Transitional Measures pertaining to Penal Provisions)

2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(2) With regard to the application of penal provisions to acts committed prior to the enforcement of this Ordinance of the Ministry, the provisions then in force shall remain applicable.

附 則 〔平成二十年八月二十七日経済産業省令第五十五号〕

**Supplementary Provisions [Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry No. 55 of August 27, 2008]**

この省令は、平成二十年十一月一日から施行する。

This Ordinance of the Ministry shall come into effect as from November 1, 2008.

別表第一（第十九条関係）

Appended Table No. 1 (Re: Art. 19)

	マイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ又はマイクロコントローラの種類 Microprocessors, microcomputers and microcontrollers	複合理論性能 Composite theoretical performance
1	一の計算要素のみを有するもの Having a single computational element	当該計算要素の理論性能 Theoretical performance of that element
2	すべてが個別に動作する複数の計算要素を有するもの Having multiple computational elements, all of which function separately and independently	当該計算要素の理論性能のうち最大のもの Greatest theoretical performance of these computational elements
3	すべてが、同時に動作し、かつ、記憶装置を共有する複数の計算要素を有するもの Having multiple computational elements, all of which function simultaneously and share a memory device	当該計算要素の理論性能のうち最大のものに、その他の計算要素の理論性能に〇・七五をそれぞれ乗じて得た値をすべて加えたもの Value of the greatest theoretical performance of these computational elements, added to the value obtained by multiplying the theoretical performance of each and every other elements by 0.75
4	削除 Deleted	削除 Deleted
5	すべてが、同時に動作し、かつ、記憶装置を共有しない複数の計算要素を有するもの Having multiple computational elements, all of which function simultaneously but do not share a memory device	当該計算要素の理論性能のうち最大のものに、その他の計算要素の理論性能に次に定める係数をそれぞれ乗じて得た値をすべて加えたもの Value of the greatest theoretical performance of these computational elements, added to the value obtained by multiplying the theoretical performance of each and every other elements by the following coefficients

イ 計算要素の理論性能の大きい順に並べて計算要素が二番目から三二番目までのもの

(a) Computational elements ranked in descending order by theoretical performance from 2nd to 32nd

(一) 当該計算要素に接続されるすべてのチャンネルの最大データ速度（メガバイト毎秒で表したものをいう。以下五において単に「最大データ速度」という。）の和が一秒につき二〇メガバイト以上のものにあつては、〇・七五

(i) 0.75, when the sum of the maximum data speeds (expressed in megabytes per second; referred to hereinafter in this row 5 simply as "maximum data speed") of all channels to be connected to said computational elements is 20 megabytes or more per second

(二) 最大データ速度の和が一秒につき二〇メガバイト未満のものにあつては、最大データ速度の和を二〇で除した値に〇・七五を乗じた値。ただし、計算要素の複合理論性能が一秒につき五〇メガ演算を超えるものであつて、計算要素が二番目から一二番目までのものにあつては、〇・七五

(ii) The value obtained by multiplying 0.75 by the value dividing the sum of the maximum data speeds by 20, when the sum of the maximum data speeds is less than 20 megabytes per second. However, 0.75 for computational elements ranked 2nd through 12th, when the composite theoretical performance of the computational elements exceeds 50 megabytes.

ロ 計算要素の理論性能の大きい順に並べて計算要素が三三番目から六四番目までのもの

(b) Computational elements ranked in descending order by theoretical performance from 33rd to 64th

(一) 最大データ速度の和が一秒につき二〇メガバイト以上のものにあつては、〇・六

(i) 0.6, when the sum of the maximum data speeds is 20 megabytes or more per second

(二) 最大データ速度の和が一秒につき二〇メガバイト未満のものにあつては、最大データ速度の和を二〇で除した値に〇・六を乗じた値

(ii) The value obtained by multiplying 0.6 by the value dividing the sum of the maximum data speeds by 20, when the sum of the maximum data speeds is less than 20 megabytes per second.

ハ 計算要素の理論性能の大きい順に並べて計算要素が六五番目から二五六番目までのもの

(c) Computational elements ranked in descending order by theoretical performance from 65th to 256th

(一) 最大データ速度の和が一秒につき二〇メガバイト以上のものにあつては、〇・四五

(i) 0.45, when the sum of the maximum data speeds is 20 megabytes or more per second

(二) 最大データ速度の和が一秒につき二〇メガバイト未満のものにあつては、最大データ速度の和を二〇で除した値に〇・四五を乗じた値

(ii) The value obtained by multiplying 0.45 by the value dividing the sum of the maximum data speeds by 20, when the sum of the maximum data speeds is less than 20 megabytes per second.

ニ 計算要素の理論性能の大きい順に並べて計算要素が二五六番目を超えるもの

(d) Computational elements ranked in descending order by theoretical performance below 256th

(一) 最大データ速度の和が一秒につき二〇メガバイト以上のものにあつては、〇・三

(i) 0.3, when the sum of the maximum data speeds is 20 megabytes or more per second

	<p>(二) 最大データ速度の和が一秒につき二〇メガバイト未満のものにあつては、最大データ速度の和を二〇で除した値に〇・三を乗じた値</p> <p>(ii) The value obtained by multiplying 0.3 by the value dividing the sum of the maximum data speeds by 20, when the sum of the maximum data speeds is less than 20 megabytes per second.</p>
<p>すべてが同時に動作し、かつ、記憶装置を共有する複数の計算要素を有するものと記憶装置を共有しない複数の計算要素又は計算要素の集まりとの両方を有するもの</p> <p>Having multiple computational elements, all of which function simultaneously and share a memory device, combined with multiple computational elements or a collection of computational elements, which do not share a memory device</p>	<p>次の計算手順により算出した値</p> <p>Value calculated according to the following procedures</p> <p>イ すべてが同時に動作し、かつ、記憶装置を共有する複数の計算要素についてそれぞれ三に従い理論性能を求める。</p> <p>(a) For computational elements, all of which function simultaneously and share a memory device, obtain the theoretical performance in accordance with Row 3.</p> <p>ロ イで得た理論性能又は記憶装置を共有しない計算要素の理論性能のうち最大のものに、その他の理論性能に次に定める係数をそれぞれ乗じて得た値をすべて加えたもの</p> <p>(b) The greatest theoretical performance among the values obtained by means of (a) or the theoretical performance of computing elements which do not share a memory device, added to all the values obtained by multiplying the theoretical performances for the each and every others by the coefficients specified below.</p>

(一) 計算要素又は計算要素の集まりの理論性能の大きい順に並べて計算要素が二番目から三二番目までのもの

(i) Computational elements or collections of computational elements ranked in descending order by theoretical performance from 2nd to 32nd

1 当該計算要素又は計算要素の集まりに接続されるすべてのチャンネルの最大データ速度（メガバイト毎秒で表したものをいう。以下六において単に「最大データ速度」という。）の和が一秒につき二〇メガバイト以上のものにあつては、〇・七五

(1) 0.75, when the sum of the maximum data speeds (expressed in megabytes per second; referred to hereinafter in this row 6 simply as "maximum data speed") of all channels to be connected to said computational elements or collections of computational elements is 20 megabytes or more per second

2 最大データ速度の和が一秒につき二〇メガバイト未満のものにあつては、最大データ速度の和を二〇で除した値に〇・七五を乗じた値。ただし、計算要素又は計算要素の集まりの複合理論性能が一秒につき五〇メガ演算を超えるものであつて、計算要素が二番目から一二番目までのものにあつては、〇・七五

(2) The value obtained by multiplying 0.75 by the value dividing the sum of the maximum data speeds by 20, when the sum of the maximum data speeds is less than 20 megabytes per second. However, 0.75 for computational elements ranked 2nd through 12th, when the composite theoretical performance of the computational elements or collection of computational elements exceeds 50 megabytes.

(二) 計算要素又は計算要素の集まりの理論性能の大きい順に並べて計算要素が三三番目から六四番目までのもの

(ii) Computational elements or collections of computational elements ranked in descending order by theoretical performance from 33rd to 64th

1 当該計算要素又は計算要素の集まりに接続されるすべてのチャンネルの最大データ速度の和が一秒につき二〇メガバイト以上のものにあつては、〇・六

(1) 0.6, when the sum of the maximum data speeds for all channels to be connected to the computational elements or collections of computational elements is 20 megabytes or more per second

2 最大データ速度の和が一秒につき二〇メガバイト未満のものにあつては、最大データ速度の和を二〇で除した値に〇・六を乗じた値

(2) The value obtained by multiplying 0.6 by the value dividing the sum of the maximum data speeds by 20, when the sum of the maximum data speeds is less than 20 megabytes per second.

(三) 計算要素又は計算要素の集まりの理論性能の大きい順に並べて計算要素が六五番目から二五六番目までのもの

(iii) Computational elements and collections of computational elements ranked in descending order by theoretical performance from 65th to 256th

1 当該計算要素又は計算要素の集まりに接続されるすべてのチャンネルの最大データ速度の和が一秒につき二〇メガバイト以上のものにあつては、〇・四五

(1) 0.45, when the sum of the maximum data speeds for all channels to be connected to the computational elements or collections of computational elements is 20 megabytes per second

2 最大データ速度の和が一秒につき二〇メガバイト未満のものにあつては、最大データ速度の和を二〇で除した値に〇・四五を乗じた値

(2) The value obtained by multiplying 0.45 by the value dividing the sum of the maximum data speeds by 20, when the sum of the maximum data speeds is less than 20 megabytes per second.



		<p>(四) 計算要素又は計算要素の集まりの理論性能の大きい順に並べて計算要素が二五六番目を超えるもの</p> <p>(iv) Computational elements and collections of computational elements ranked in descending order by theoretical performance below 256th</p> <p>1 当該計算要素又は計算要素の集まりに接続されるすべてのチャンネルの最大データ速度の和が一秒につき二〇メガバイト以上のものにあつては、〇・三</p> <p>(1) 0.3, when the sum of the maximum data speeds for all channels to be connected to the computational elements or collections of computational elements is 20 megabytes or more per second</p> <p>2 最大データ速度の和が一秒につき二〇メガバイト未満のものにあつては、最大データ速度の和を二〇で除した値に〇・三を乗じた値</p> <p>(2) The value obtained by multiplying 0.3 by the value dividing the sum of the maximum data speeds by 20, when the sum of the maximum data speeds is less than 20 megabytes per second.</p>
7	<p>複数の計算要素を有するもの（二、三、五又は六のいずれかに該当するものを除く。）</p> <p>Having multiple computational elements (other than those governed by Rows 2, 3, 5 or 6)</p>	<p>単独に動作する計算要素の理論性能又は同時に動作する計算要素の組合わせの理論性能のうち最大のもの。なお、同時に動作する計算要素の組合わせの理論性能は、三、五又は六で得た値とする。</p> <p>The theoretical performance of a computational element functioning independently, or the greatest theoretical performance of a combination of computational elements functioning simultaneously. The theoretical performance for a combination of computational elements functioning simultaneously is the value obtained from row 3, 5 or 6.</p>

別表第二（第十条、第十二条関係）

Appended Table No. 2 (Re: Art. 10, Art. 12)

アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、大韓民国、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、

ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、ロシア、スペイン、スロバキア、スウェーデン、スイス、トルコ、ウクライナ、英国、アメリカ合衆国

Argentina, Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, Canada, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Republic of Korea, Luxembourg, The Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Spain, Slovakia, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine, United Kingdom, United States of America

別表第三（第十八条関係）

Appended Table No. 3 (Re: Art. 18)

	コーティング方法 Coating Method	基材 Base Material	コーティング Coating
1	原料ガスの化学反応により生成するコーティング材料を基材の表面に定着させる方法 Method of fixing the coating material generated by chemical reaction of raw material gas onto the base material surface.	超合金 Superalloy	アルミニウム化合物 Aluminum compounds
		セラミック又は低熱膨張ガラス Ceramics or low-thermal expansion glasses	けい素化合物、炭化物、誘電体膜、ダイヤモンド又は非晶質ダイヤモンド状炭素膜 Silicon compounds, carbides, dielectric film, diamonds and non-crystalline diamond-like carbon films
		炭素及び炭素繊維を用いた複合材料（以下「カーボンカーボン」という。）、セラミック複合材料又は金属基複合材料 Composite material using carbon and carbon fibers (referred to hereinafter as "carbon-carbon"), ceramic composites and metal matrix composites	けい素化合物、炭化物、耐火金属、これらの組合せからなる混合物、誘電体膜、アルミニウム化合物、合金アルミニウム化合物又は窒化ほう素 Silicon compounds, carbides, refractory metals, and mixtures thereof; dielectric film, aluminum compounds, aluminum alloy compounds and boron nitride

	炭化タングステン合金 又は炭化けい素 Tungsten carbide alloys and silicon carbide	炭化物、タングステン、炭化物 とタングステンの混合物又は誘 電体膜 Carbides, tungsten, mixtures of carbides and tungsten, and dielectric film
	モリブデン又はモリブ デン合金 Molybdenum and molybdenum alloys	誘電体膜 Dielectric film
	ベリリウム又はベリリ ウム合金 Beryllium and beryllium alloys	誘電体膜、ダイヤモンド又は非 晶質ダイヤモンド状炭素膜 Dielectric film, diamonds and non-crystalline diamond-like carbon films
	センサー窓材 Sensor window material	誘電体膜、ダイヤモンド又は非 晶質ダイヤモンド状炭素膜 Dielectric film, diamonds and non-crystalline diamond-like carbon films
2	電子ビームにより蒸発 させたコーティング材 料を基材の表面に定着 させる方法 Method of fixing coating material volatilized by electronic beam onto the base material surface	超合金 Superalloys
	セラミック又は低熱膨 張ガラス Ceramics or low- thermal expansion glasses	合金けい素化合物、合金アルミ ニウム化合物、クロムアルミニ ウム合金、改良ジルコニア、け い素化合物、アルミニウム化合 物又はこれらの組合せからなる 混合物 Silicon alloy compounds, aluminum alloy compounds, chromium-aluminum alloy compounds, improved zirconia, silicon compounds, aluminum compounds and mixtures combining thereof
	耐食性を有する合金鋼 Alloy steel with corrosion resistance	誘電体膜 Dielectric film
		クロムアルミニウム合金、改良 ジルコニア又はクロムアルミニ ウム合金と改良ジルコニアの混 合物 Chromium-aluminum alloys, improved zirconia and mixtures of chromium- aluminum alloys and improved zirconia

	カーボンカーボン、セラミック複合材料又は金属基複合材料 Carbon-carbon, ceramic composites and metal matrix composites	けい素化合物、炭化物、耐火金属、これらの組合せからなる混合物、誘電体膜又は窒化ほう素 Silicon compounds, carbides, refractory metals, and mixtures thereof; dielectric film and boron nitride
	炭化タングステン合金又は炭化けい素 Tungsten carbide alloys and silicon carbide	炭化物、タングステン、炭化物とタングステンの混合物又は誘電体膜 Carbides, tungsten, mixtures of carbides and tungsten, and dielectric film
	モリブデン又はモリブデン合金 Molybdenum and molybdenum alloys	誘電体膜 Dielectric film
	ベリリウム又はベリリウム合金 Beryllium and beryllium alloys	誘電体膜、ほう素化合物又はベリリウム Dielectric film, boron alloys and beryllium
	センサー窓材 Sensor window material	誘電体膜 Dielectric film
	チタン合金 Titanium alloys	ほう素化合物又は窒素化合物 Boron compounds and nitrides
3	電気による抵抗加熱により蒸発させたコーティング材料を基材の表面に定着させる方法 Method of fixing coating material volatilized by electric resistance heating onto the surface of the base material	セラミック又は低熱膨張ガラス Ceramics or low-thermal expansion glasses
	カーボンカーボン、セラミック複合材料又は金属基複合材料 Carbon-carbon, ceramic composites and metal matrix composites	誘電体膜 Dielectric film
		誘電体膜又は非晶質ダイヤモンド状炭素膜 Dielectric film and non-crystalline diamond-like carbon film

	炭化タングステン合金 又は炭化けい素 Tungsten carbide alloys and silicon carbide	誘電体膜 Dielectric film
	モリブデン又はモリブ デン合金 Molybdenum and molybdenum alloys	誘電体膜 Dielectric film
	ベリリウム又はベリリ ウム合金 Beryllium and beryllium alloys	誘電体膜 Dielectric film
	センサー窓材 Sensor window material	誘電体膜又は非晶質ダイヤモン ド状炭素膜 Dielectric film and non- crystalline diamond-like carbon film
4	レーザーにより蒸発さ せたコーティング材料 を基材の表面に定着さ せる方法 Method of fixing coating material volatilized by laser onto the surface of the base material	セラミック又は低熱膨 張ガラス Ceramics or low- thermal expansion glasses
	カーボンカーボン、セ ラミック複合材料又は 金属基複合材料 Carbon-carbon, ceramic composites and metal matrix composites	誘電体膜 Dielectric film
	炭化タングステン合金 又は炭化けい素 Tungsten carbide alloys and silicon carbide	誘電体膜 Dielectric film
	モリブデン又はモリブ デン合金 Molybdenum and molybdenum alloys	誘電体膜 Dielectric film
	ベリリウム又はベリリ ウム合金 Beryllium and beryllium alloys	誘電体膜 Dielectric film

		センサー窓材 Sensor window material	誘電体膜又は非晶質ダイヤモンド状炭素膜 Dielectric film and non-crystalline diamond-like carbon film
5	アーク放電により蒸発させたコーティング材料を基材の表面に定着させる方法 Method of fixing coating material volatilized by arc discharge onto the surface of the base material	超合金 Superalloys	合金けい素化合物、合金アルミニウム化合物又はクロムアルミニウム合金 Silicon alloy compounds, aluminum alloy compounds and chromium-aluminum alloys
		重合体又は有機物をマトリックスとする複合材料 Composite material with polymer or organic compound matrix	ほう素化合物、炭化物、窒素化合物又は非晶質ダイヤモンド状炭素膜 Boron compounds, carbides, nitrides and non-crystalline diamond-like carbon film
6	粉末状のコーティング材料を基材とともに容器に封入し、七五七度以上の温度で加熱して、基材の表面に定着させる方法 Method of fixing the coating material onto the surface of base metal by placing powdered coating material and the base material into a container and heating to 757 degrees centigrade or more	カーボンカーボン、セラミック複合材料又は金属基複合材料 Carbon-carbon, ceramic composites or metal matrix composites	けい素化合物、炭化物又はけい素化合物と炭化物の混合物 Silicon compounds, carbides and mixtures of silicon compounds and carbides
		チタン合金 Titanium alloys	けい素化合物、アルミニウム化合物又は合金アルミニウム化合物 Silicon compounds, aluminum compounds and aluminum alloy compounds

		耐火性を有する金属又はこれらの合金 Metals and metal alloys with fireresistance	けい素化合物又は酸化物 Silicon compounds and oxides
7	プラズマ溶射をするもの Method using plasma spray coating	超合金 Superalloys	クロムアルミニウム合金、改良ジルコニア、クロムアルミニウム合金と改良ジルコニアの混合物、研磨可能なニッケルグラファイト合金、ニッケルクロムアルミニウムを含む研磨可能な物質、研磨可能なアルミニウムけい素ポリエステル合金又は合金アルミニウム化合物 Chromium-aluminum alloys, improved zirconia, mixtures of chromium-aluminum alloys and improved zirconia, nickel-graphite alloys capable of being polished, substances containing nickel-chromium-aluminum capable of being polished, and aluminum-silicon polyester alloys and aluminum alloy compounds capable of being polished
		アルミニウム合金 Aluminum alloys	クロムアルミニウム合金、改良ジルコニア、けい素化合物又はこれらの組合せからなる混合物 Chromium-aluminum alloys, improved zirconia, silicon compounds and mixtures combining thereof
		耐火性を有する金属又はこれらの合金 Metals and metal alloys with fire resistance	アルミニウム化合物、けい素化合物又は炭化物 Aluminum compound, silicon compounds and carbides
		耐食性を有する合金鋼 Alloy steel with corrosion resistance	クロムアルミニウム合金、改良ジルコニア又はクロムアルミニウム合金と改良ジルコニアの混合物 Chromium-aluminum alloys, improved zirconia and mixtures of chromium-aluminum alloys and improved zirconia

		チタン合金 Titanium alloys	炭化物、アルミニウム化合物、けい素化合物、合金アルミニウム化合物、研磨可能なニッケルグラファイト合金、ニッケルクロムアルミニウムを含む研磨可能な物質又は、研磨可能なアルミニウムけい素ポリエステル合金 Carbides, aluminum compounds, silicon compounds, aluminum alloy compounds, nickel-graphite alloys capable of being polished, substances containing nickel-chromium-aluminum capable of being polished, and aluminum-silicon polyester alloys capable of being polished
ナ 8	スラリー状にしたコーティング材料を基材の表面に定着させる方法 Method of fixing slurried coating material onto the surface of base material	耐火性を有する金属又はこれらの合金 Metals and metal alloys with fire resistance	熔融したけい素化合物又は熔融したアルミニウム化合物 Molten silicon compounds and molten aluminum compounds
		カーボンカーボン、セラミック複合材料又は金属基複合材料 Carbon-carbon, ceramic composites and metal matrix composites	けい素化合物、炭化物又はけい素化合物と炭化物の混合物 Silicon compounds, carbides and mixtures of silicon compounds and carbides
ナ 9	スパッタリング法 Method of sputtering	超合金 Superalloys	合金けい素化合物、合金アルミニウム化合物、貴金属を用いたアルミニウム化合物、クロムアルミニウム合金、改良ジルコニア、白金又はこれらの組合せからなる混合物 Silicon alloy compounds, aluminum alloy compounds, aluminum compounds containing precious metals, chromium-aluminum alloys, improved zirconia, platinum and mixtures thereof



セラミック又は低熱膨張ガラス Ceramics or low-thermal expansion glasses	けい素化合物、白金、けい素化合物と白金の混合物、誘電体膜又は非晶質ダイヤモンド状炭素膜 Silicon compounds, platinum, mixtures of silicon compounds and platinum, dielectric film and non-crystalline diamond-like carbon film
チタン合金 Titanium alloys	ほう素化合物、窒素化合物、酸化物、けい素化合物、アルミニウム化合物、合金アルミニウム化合物又は炭化物 Boron compounds, nitrides, oxides, silicon compounds, aluminum compounds, aluminum alloy compounds and carbides
カーボンカーボン、セラミック複合材料又は金属基複合材料 Carbon-carbon, ceramic composites and metal matrix composites	けい素化合物、炭化物、耐火金属、これらの組合せからなる混合物、誘電体膜又は窒化ほう素 Silicon compounds, carbides, refractory metals and mixtures thereof; dielectric film and boron nitride
炭化タングステン合金又は炭化けい素 Tungsten carbide alloys and silicon carbide	炭化物、タングステン、炭化物とタングステンの混合物、誘電体膜又は窒化ほう素 Carbides, tungsten and mixtures of carbides and tungsten; dielectric film and boron nitride
モリブデン又はモリブデン合金 Molybdenum and molybdenum alloys	誘電体膜 Dielectric film
ベリリウム又はベリリウム合金 Beryllium and beryllium alloys	ほう素化合物、誘電体膜又はベリリウム Boron compounds, dielectric film and beryllium
センサー窓材 Sensor window material	誘電体膜又は非晶質ダイヤモンド状炭素膜 Dielectric film and non-crystalline diamond-like carbon film

	耐火性を有する金属又はこれらの合金 Metals and metal alloys with fire resistance	アルミニウム化合物、けい素化合物、酸化物又は炭化物 Aluminum compounds, silicon compounds, oxides and carbides
1 0 イオン注入法 Method of ion implantation	高温ベアリング鋼 High temperature bearing steel	クロム、タンタル又はニオブの添加物 Chromium, tantalum and niobium additives
	チタン合金 Titanium alloys	ほう素化合物又は窒素化合物 Boron compounds and nitrides
	ベリリウム又はベリリウム合金 Beryllium and beryllium alloys	ほう素化合物 Boron compounds
	炭化タングステン合金 Tungsten carbide alloys	炭化物又は窒素化合物 Carbides and nitrides